

In Zukunft

Geschäftsbericht 2015



Kennzahlen

in Mio. €	2015	2014	Veränderung 2015/2014
Geschäftsentwicklung			
Auftragseingang	188,6	134,3	40,4 %
Auftragsbestand zum 31.12.	117,6	75,6	55,6 %
Umsatz gesamt	148,5	145,3	2,2 %
Umsatzrendite	0,1 %	3,2 %	-3,1 %-Punkte
Rohertrag	49,4	48,8	1,2 %
Rohertragsmarge	33,3 %	33,6 %	-0,3 %-Punkte
Herstellungskosten	99,2	96,5	2,8 %
Forschungs- und Entwicklungskosten	12,8	10,5	21,9 %
EBITDA	9,2	12,6	-27,0 %
EBITDA-Marge	6,2 %	8,7 %	-2,5 %-Punkte
EBIT	5,0	8,4	-40,5 %
EBIT-Marge	3,4 %	5,8 %	-2,4 %-Punkte
Ergebnis nach Steuern	0,2	4,6	-95,7 %
Ergebnis je Aktie, unverwässert (in €)	0,01	0,24	-95,8 %
Bilanz und Cashflow			
Eigenkapital	118,7	116,1	2,2 %
Eigenkapitalquote	67,0 %	69,1 %	-2,1 %-Punkte
Eigenkapitalrentabilität	0,2 %	4,0 %	-3,8 %-Punkte
Bilanzsumme	177,2	168,0	5,5 %
Net Cash	40,0	38,0	5,3 %
Free Cashflow ¹	1,3	2,1	-38,1 %
Weitere Kennzahlen			
Investitionen	3,4	3,0	13,3 %
Investitionsquote	2,3 %	2,1 %	0,2 %-Punkte
Abschreibungen	4,2	4,2	0,0 %
Mitarbeiter zum 31.12.	698	659	5,9 %

¹ vor Berücksichtigung von Wertpapiererwerben und Wertpapierverkäufen

Inhalt

Vorwort des Vorstands	6	Konzernabschluss nach IFRS	84
Unsere Strategie im Überblick	8	Anhang zum IFRS-Konzernabschluss	100
Bericht des Aufsichtsrats	18	Glossar	140
Investor Relations	22	Finanzkalender 2016	145
Corporate Governance	26	Fünfjahresübersicht	147
Zusammengefasster Lagebericht	32		

Liebe Leserinnen und Leser,

im Geschäftsjahr 2015 haben wir in einem schwierigen Marktumfeld sehr erfreuliche Auftragseingänge verbuchen können.

Die positive Entwicklung gipfelte im vierten Quartal 2015 in einem Rekordauftragseingang in Höhe von 79,7 Mio. Euro.

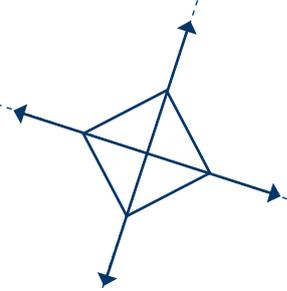
Es handelte sich hierbei um einen Rekordwert, der selbst in den Boomjahren 1999 und 2000 nicht erreicht wurde. Im folgenden Bericht erfahren Sie mehr über unser erfolgreiches Geschäftsjahr 2015.

SÜSS MicroTec ist ein Unternehmen mit einer starken Historie und großem Potenzial. In Zukunft wollen wir die Präsenz in unseren angestammten Kern- aber auch in neuen Marktsegmenten verstärken.

Die strategische Ausrichtung auf attraktive und wachstumsstarke Märkte wie das Advanced Packaging, den MEMS-Markt sowie die 3D-Integration ist nach wie vor sehr vielversprechend und wird von uns auch zukünftig fortgesetzt.

Um das Unternehmen nachhaltig auf einen Wachstumspfad zu führen, werden wir unser Augenmerk weiterhin auf die konsequente Umsetzung der im Geschäftsjahr 2014 begonnenen und 2015 fokussierten Strategie richten. Dies bedeutet unter anderem eine weitere Stärkung der Kernproduktlinien sowie den Einstieg in neue Segmente in unseren Zielmärkten.

Ihr SÜSS MicroTec-Vorstand



Weltweit erfolgreich

Lithografie

- Mask Aligner
- UV-Projektionsbelichtungssysteme
- Laser Prozessierungssysteme
- Belacker/Entwickler

Auftragseingang:

149,6 Mio. Euro

Umsatz: 106,3 Mio. Euro

EBIT: 9,7 Mio. Euro

Substrat Bonder

- Substrat (Wafer) Bonder

Auftragseingang:

10,5 Mio. Euro

Umsatz: 11,4 Mio. Euro

EBIT: -4,0 Mio. Euro

Fotomasken Equipment

- Fotomaskenbearbeitungssysteme

Auftragseingang:

21,5 Mio. Euro

Umsatz: 23,5 Mio. Euro

EBIT: 2,3 Mio. Euro

Sonstige

- Mikrooptik und -linsen
- Zentrale Konzernfunktionen

Auftragseingang:

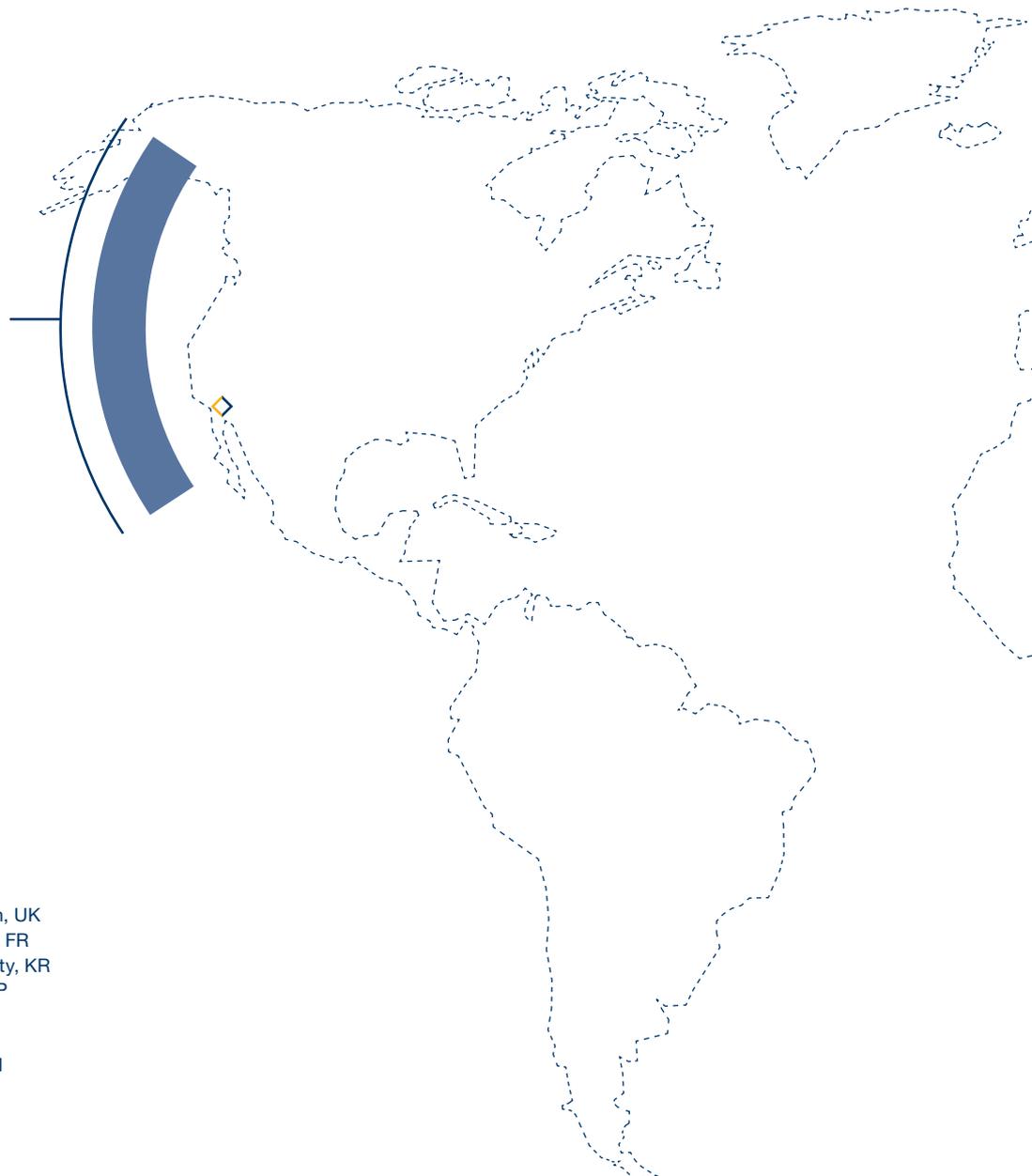
7,0 Mio. Euro

Umsatz: 7,3 Mio. Euro

EBIT: -3,1 Mio. Euro

Nord-amerika
18,8%

Umsatz nach Regionen



Produktion

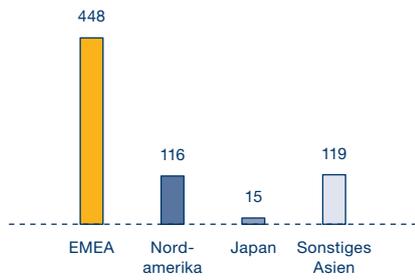
Corona, US
Hauterive, CH
Garching, DE
(Hauptsitz)
Sternenfels, DE



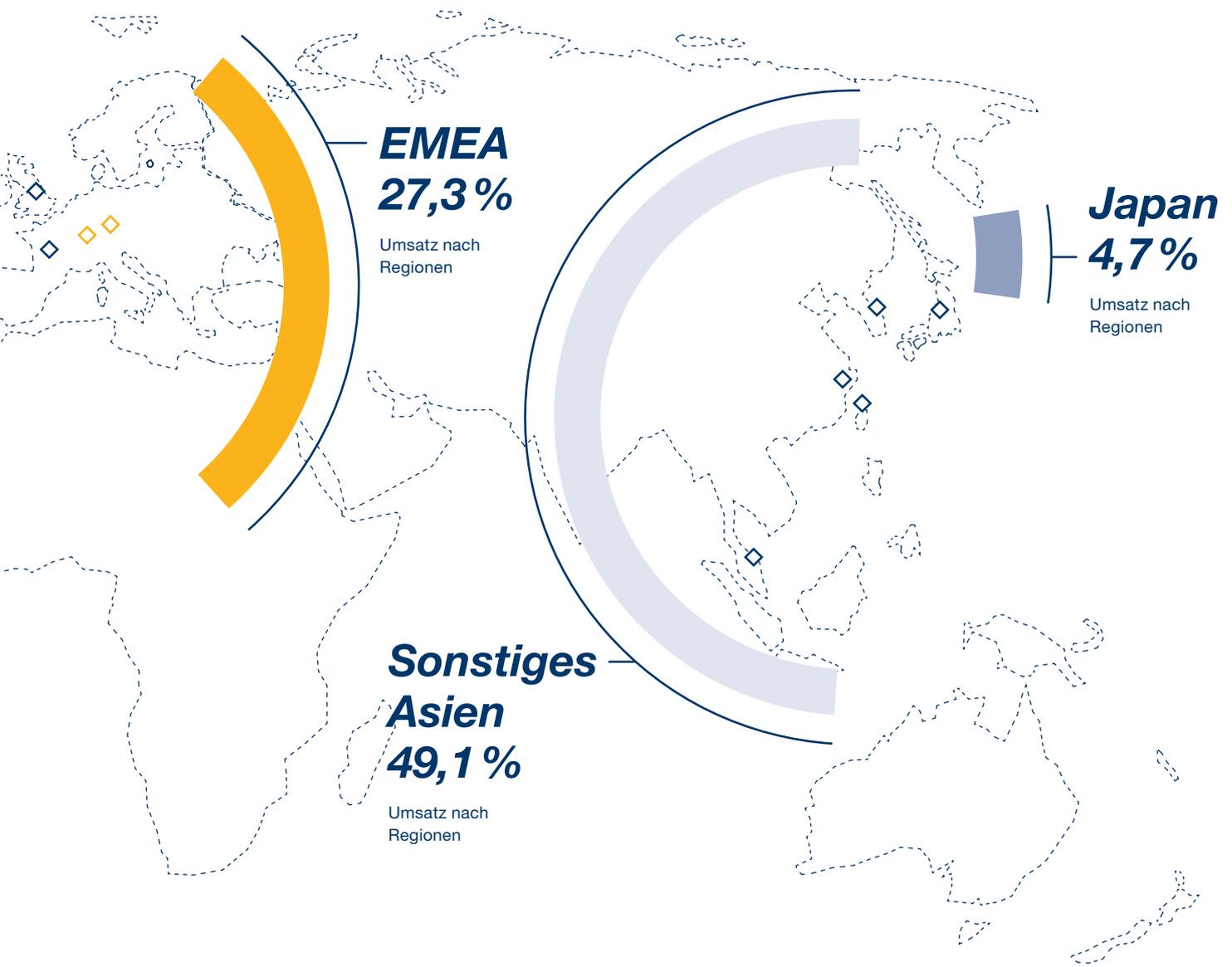
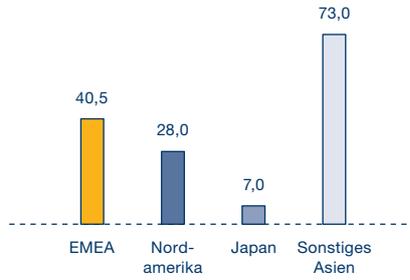
Vertrieb

Corona, US
Market Rasen, UK
Pierre Bénite, FR
Hwaseong City, KR
Yokohama, JP
Hsinchu, TW
Singapur, SG
Shanghai, CN

Mitarbeiter nach Regionen



Umsatz nach Regionen in Mio. €



Vorwort des Vorstands

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

wir blicken heute auf ein in jeder Hinsicht ereignisreiches Jahr 2015 zurück. Auf europäischer Ebene war das zurückliegende Jahr maßgeblich von der anhaltenden Flüchtlingsbewegung aus Syrien und umliegenden Ländern sowie den Terroranschlägen in Paris geprägt. Aus wirtschaftlicher Sicht prägte die Wechselkursentwicklung des Schweizer Franken sowie die Zitterpartie um den Verbleib Griechenlands in der Europäischen Währungsunion das Jahr. Zudem hat sich das Wirtschaftswachstum im Jahresverlauf in den Schwellenländern und insbesondere in China zunehmend abgekühlt und zu globalen Konsequenzen geführt. Der anhaltend niedrige Ölpreis sowie die insgesamt deutlich gefallen Rohstoffpreise machen den Schwellenländern weiterhin zu schaffen. Gemäß den Schätzungen der OECD von Februar 2016 lag das globale Wirtschaftswachstum im Geschäftsjahr 2015 bei rund 3,0 Prozent nach 3,3 Prozent im Vorjahr.

In einem von Unsicherheiten geprägten konjunkturellen Umfeld hat SÜSS MicroTec das Geschäftsjahr 2015 erfolgreich abschließen können. Es ist uns gelungen, das Unternehmen im Hinblick auf Umsatz und Ergebnis zu stabilisieren und darüber hinaus einen sehr hohen Auftragsbestand zum Ende des Geschäftsjahres 2015 zu erwirtschaften. Dies ist insbesondere bemerkenswert, da sich der Halbleiter- und der Halbleiter-Equipment-Markt im abgelaufenen Geschäftsjahr eher verhalten entwickelt haben. War man noch im April bzw. Juli 2015 von einem Wachstum im Halbleiter-Markt um 4,0 bzw. 2,2 Prozent ausgegangen, so wird für 2015 laut den aktuellsten Schätzungen sogar ein leichter Rückgang in der Branche um 1,9 Prozent gegenüber 2014 erwartet (Gartner, 7. Januar 2016). Die Gründe hierfür sind im Wesentlichen die erneut reduzierten Absatzprognosen für Smartphones, Tablets und PCs sowie der starke US-Dollar Wechselkurs, welcher die Preise für Endgeräte in lokaler Währung in vielen Regionen ansteigen ließ. Auch unser Segment Halbleiter-Equipment für Wafer-Level Manufacturing entwickelt sich eher moderat, so erwartet man für das laufende Jahr 2016 einen Rückgang in diesem Bereich um 2,4 Prozent nach einem leichten Anstieg um 0,1 Prozent im Geschäftsjahr 2015 (Gartner, 11. Januar 2016). In diesem Marktumfeld konnten wir allein im vierten Quartal 2015 einen Rekordauftragseingang in Höhe von rund 79,7 Mio. Euro verbuchen. Dies ist nach 70,4 Mio. Euro im vierten Quartal 2000 ein neuer Höchstwert im Auftragseingang in unserer Unternehmensgeschichte. Für das laufende

Geschäftsjahr erwarten wir entsprechend des hohen Auftragsbestands eine deutliche Steigerung des Umsatzes und eine weitere Stabilisierung der Geschäftssituation. Wir arbeiten mit Hochdruck an der strategischen Weiterentwicklung des Unternehmens, um unsere Leistungsfähigkeit und Innovationskraft nachhaltig zu stärken. Die wachsende Unsicherheit im Hinblick auf die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen bereitet uns allerdings Sorgen. Wir blicken daher verhalten optimistisch auf das Geschäftsjahr 2016. Wir werden von Vorstandsseite alles tun, um Ihr Unternehmen auf Kurs zu halten und den eingeschlagenen Weg des profitablen Wachstums konsequent umzusetzen. Wie bereits im Geschäftsbericht 2014 angekündigt, haben wir uns auf die Stärkung unseres Kerngeschäfts sowie den konsequenten Ausbau neuer und zukunftssträchtiger Technologien fokussiert. Durch gezielte Entwicklungsmaßnahmen konnten wir bereits erste Erfolge erzielen und verlorene Marktanteile im Bereich Belacker/Entwickler zurückgewinnen sowie unsere führende Position bei den Mask Alignern ausbauen. Zudem konnten wir erste Bestellungen eines bedeutenden internationalen Halbleiterherstellers für unseren vielversprechenden Projektions-scanner DSC300 Gen2 verbuchen.

Strategie

Meine Damen und Herren, SÜSS MicroTec ist ein Unternehmen mit großem Potenzial, welches seinen Kunden technologisch anspruchsvolle und innovative Maschinen und Lösungen bietet. In einer durch zunehmenden Wettbewerb geprägten Branche müssen wir zukünftig noch gezielter auf die Wünsche und Bedürfnisse der Kunden eingehen und unsere Reaktionszeiten auf Kundenanfragen verringern. Unser Ziel ist es, der anerkannte Ansprechpartner für Lithografielösungen im Halbleiter-Mid- und Backend zu werden. Um dies zu erreichen, wollen wir durch gezielte Verbesserungen an unseren Kernproduktlinien Mask Aligner, Belacker und Entwickler sowie den Substrat Bondern Marktanteile zurückgewinnen beziehungsweise ausweiten. Darüber hinaus werden wir angrenzende Marktsegmente im Hinblick auf mögliches Potenzial analysieren. In der Produktlinie Belacker und Entwickler sehen wir bereits erste Erfolge und nutzen dies als Ansporn, den eingeschlagenen Weg konsequent weiter zu verfolgen. Wir wollen Ihr Unternehmen langfristig auf einen profitablen Wachstumspfad bringen, damit auch Sie, liebe Aktionärinnen und Aktionäre, am Unternehmenserfolg teilhaben können.



Von links nach rechts: Michael Knopp, Finanzvorstand; Dr. Per-Ove Hansson, Vorstandsvorsitzender; Walter Braun, Produktionsvorstand

Die Aktie

Nachdem die SÜSS MicroTec-Aktie das Börsenjahr 2015 am 2. Januar mit einem Schlusskurs von 4,88 Euro begonnen hatte, konnte der Aktienkurs insbesondere in der zweiten Jahreshälfte deutlich zulegen und hat das Jahr mit einem Xetra-Schlusskurs von 8,35 Euro abgeschlossen. Diese positive Entwicklung reflektiert zum einen die allgemein positive Entwicklung am Aktienmarkt im vierten Quartal 2015, vielmehr aber reagierte unser Aktienkurs auf die mehrmalige Erhöhung der Auftragseingangsguidance im dritten und vierten Quartal 2015 in einem allgemein schwachen Branchenumfeld.

Garching, im März 2016

Michael Knopp
Finanzvorstand

Dr. Per-Ove Hansson
Vorstandsvorsitzender

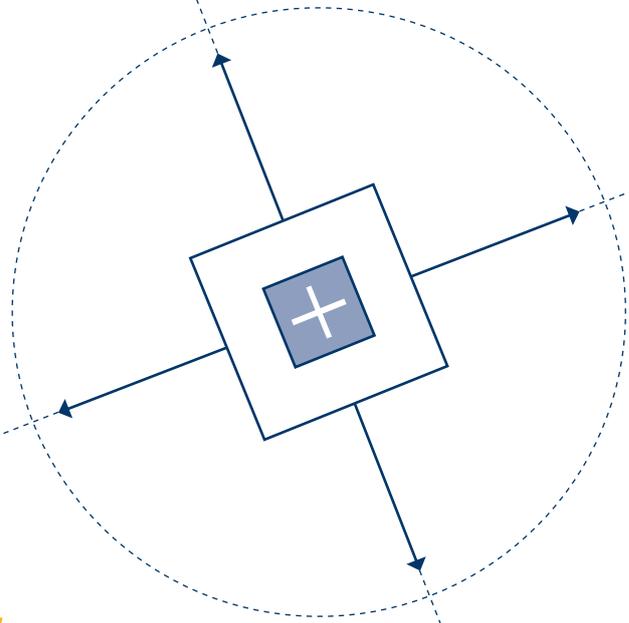
Walter Braun
Produktionsvorstand

Ausblick

Aufgrund des Auftragsbestands zum Jahresende 2015 und der erwarteten Auftragseingangsentwicklung für das erste Halbjahr 2016 prognostiziert das Unternehmen einen Umsatz für das laufende Geschäftsjahr in der Bandbreite zwischen 170 und 180 Mio. Euro sowie ein Ergebnis (EBIT) in der Bandbreite zwischen 9 und 13 Mio. Euro. Nach einem extrem starken vierten Quartal 2015 wird für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2016 ein Auftragseingang in Höhe von 25 bis 35 Mio. Euro erwartet.

Unsere Strategie im Überblick

Eine umfassende Überprüfung unserer Strategie hat ergeben, dass die strategische Ausrichtung des Unternehmens weiterhin im Einklang mit unseren langfristigen Unternehmenszielen steht, sodass keine gravierende Änderung der strategischen Ausrichtung nötig ist. Dennoch sind in einzelnen Bereichen Anpassungen sowie eine stärkere Fokussierung notwendig. Unsere wichtigsten strategischen Ziele sowie die ersten Erfolgsgeschichten finden Sie auf den folgenden Seiten.

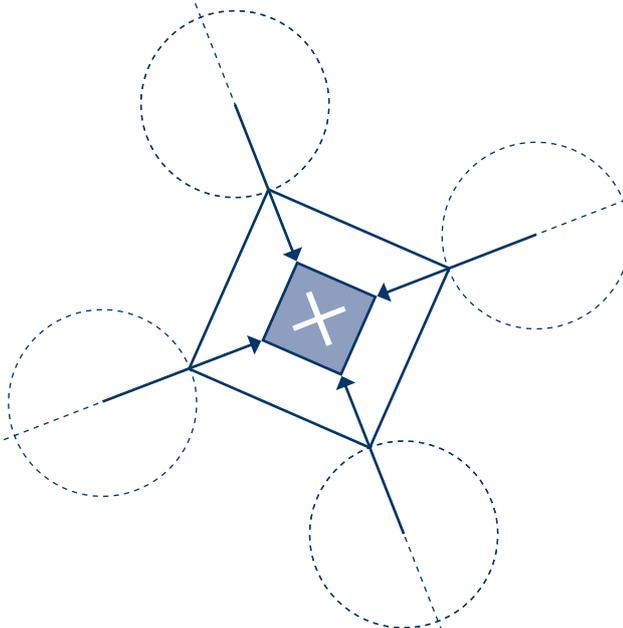


Anerkannter Marktführer im Bereich Advanced Packaging für Halbleiterbauelemente werden

Mit unseren Kernanwendungen bedienen wir den attraktiven Markt für Advanced Packaging, insbesondere die sich zuletzt sehr dynamisch entwickelnden Teilbereiche Fan-out Wafer-Level Packaging, Copper-pillar bumping sowie die 2,5D-Integration. Es ist ein wichtiges strategisches Unternehmensziel, mit unseren innovativen Lithografielösungen Marktanteile zu gewinnen und der anerkannte Marktführer im Advanced Packaging zu werden. Dabei spielen unsere neuartigen und differenzierten Projektions-scanner, die bewährten Mask Aligner sowie unsere modernen Belacker und Entwickler eine entscheidende Rolle. Durch die Entwicklung von

verschiedenen neuen Produkteigenschaften und der damit verbundenen Verringerung der Betriebskosten sowie der gesteigerten Leistungsfähigkeit ist es uns bereits gelungen, unseren Marktanteil bei den Mask Alignern sowie bei den Belackern und Entwicklern auszuweiten. Zudem konnten wir bereits erste Erfolge bei unseren Scannersystemen verzeichnen. Durch unsere neuartigen Scannersysteme konnten wir nun auch Aufträge für anspruchsvolle Lithografieanwendungen – wie beispielsweise das Fan-out Wafer-Level Packaging – gewinnen, bei welchem eine hohe Präzision und eine hohe Auflösung gefordert sind.





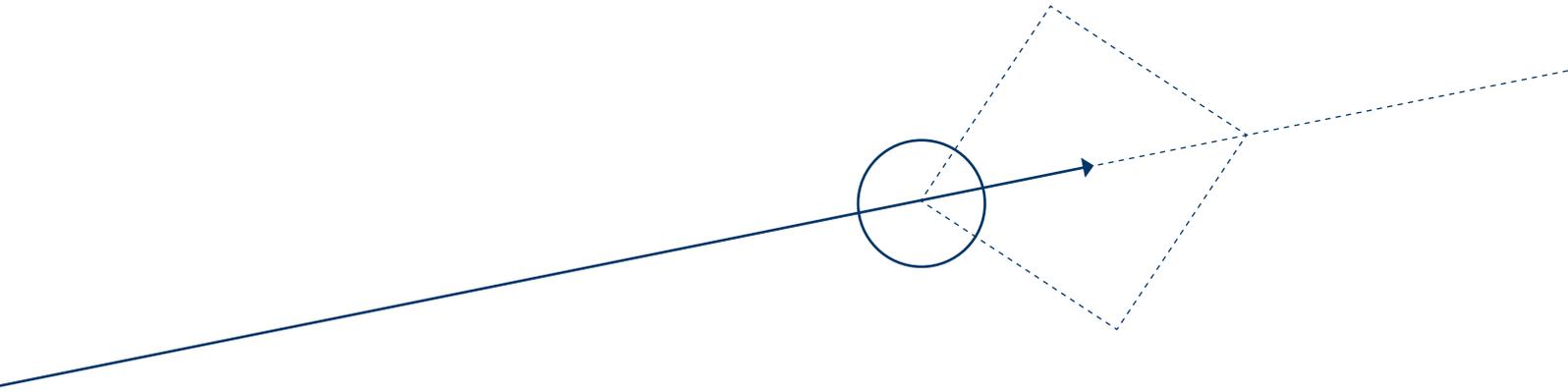
Profitables Wachstum in den Bereichen MEMS, 3D-Integration und angrenzenden Anwendungen generieren

Neben der Ausweitung unseres bestehenden Lithografiegeschäfts im Bereich Advanced Packaging wollen wir unser Produktportfolio in dem dynamischen Markt für MEMS und Sensorik verbreitern. Dieser Marktbereich ist im Wachstumsmodus und wird insbesondere durch Anwendungen für das Internet of Things sowie den Automobilsektor getrieben. Wir haben im abgelaufenen Geschäftsjahr einen vielversprechenden, neuen permanenten Bonder in den Markt eingeführt. Das Bonden ist eine bedeutende Technologie, die bei der Herstellung dieser Halbleiterbauelemente zum Einsatz kommt und wir sind entschlossen, unsere Präsenz in diesem Marktsegment auszubauen.

Eine weitere vielversprechende Anwendung für unsere Substrat Bonder ist die 3D-Integration. In diesem Bereich ist es uns gelungen weitere Aufträge von führenden internationalen Kunden zu gewinnen. Wir sehen uns nach wie vor in einer hervorragenden Position, um vom zukünftigen Wachstum in diesem Marktsegment zu profitieren.

SÜSS MicroTec besitzt ein vielfältiges und umfassendes Technologieportfolio. Wir werden die bestehenden Technologien nutzen und miteinander kombinieren, um angrenzende Märkte für uns zu erschließen. Wir sind derzeit in einer sehr frühen Phase, sehen aber das Potenzial für konkrete Möglichkeiten in der Zukunft.



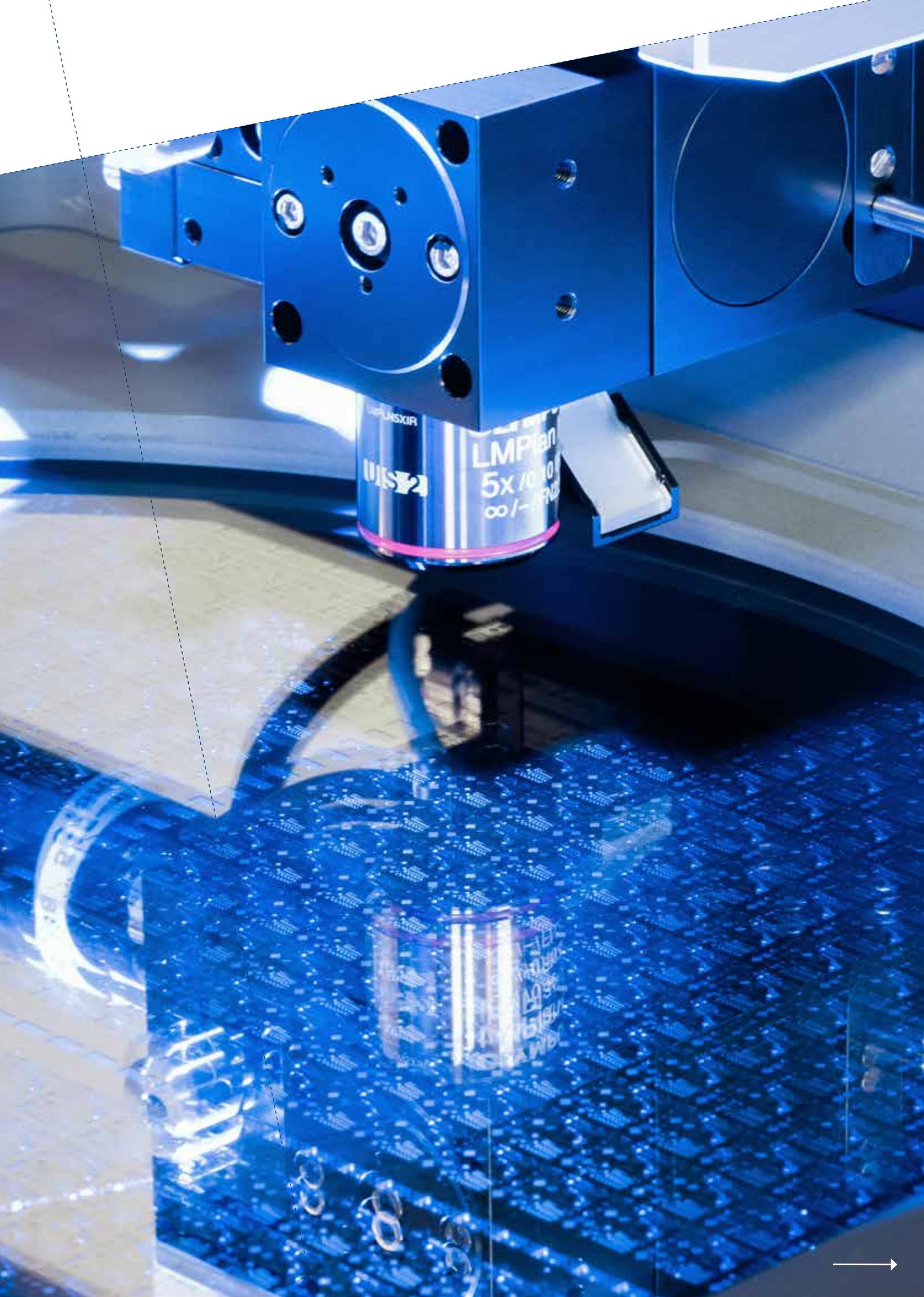


Belichtung und Laserprozessierung

Der Bereich Belichtung (Exposure) umfasst bei uns die drei Produktgruppen Mask Aligner, Projektionsscanner sowie Geräte zur Laserprozessierung. Bei der Belichtung wird mittels lithografischer Verfahren eine Struktur auf ein Substrat aufgebracht. Die seit Jahren sehr erfolgreich am Markt etablierten Mask Aligner übertragen die gewünschte Struktur mittels Schattenwurfverfahren (Vollfeldbelichtung) durch eine Maske auf das Substrat. Bei der neuartigen Belichtung mit Projektionsscannern wird zur Übertragung der Strukturen zusätzlich eine Projektionsoptik verwendet. Der Vorteil dieses Verfahrens ist die Übertragung deutlich kleinerer Strukturen, allerdings ist der Prozess dafür etwas teurer und langsamer. Die Laserprozessierung ist für uns derzeit ein vielversprechendes Zukunftsthema, da hiermit verschiedene Lithografieschritte eingespart werden könnten und verbesserte, neuartige Materialien effizient strukturiert werden können.

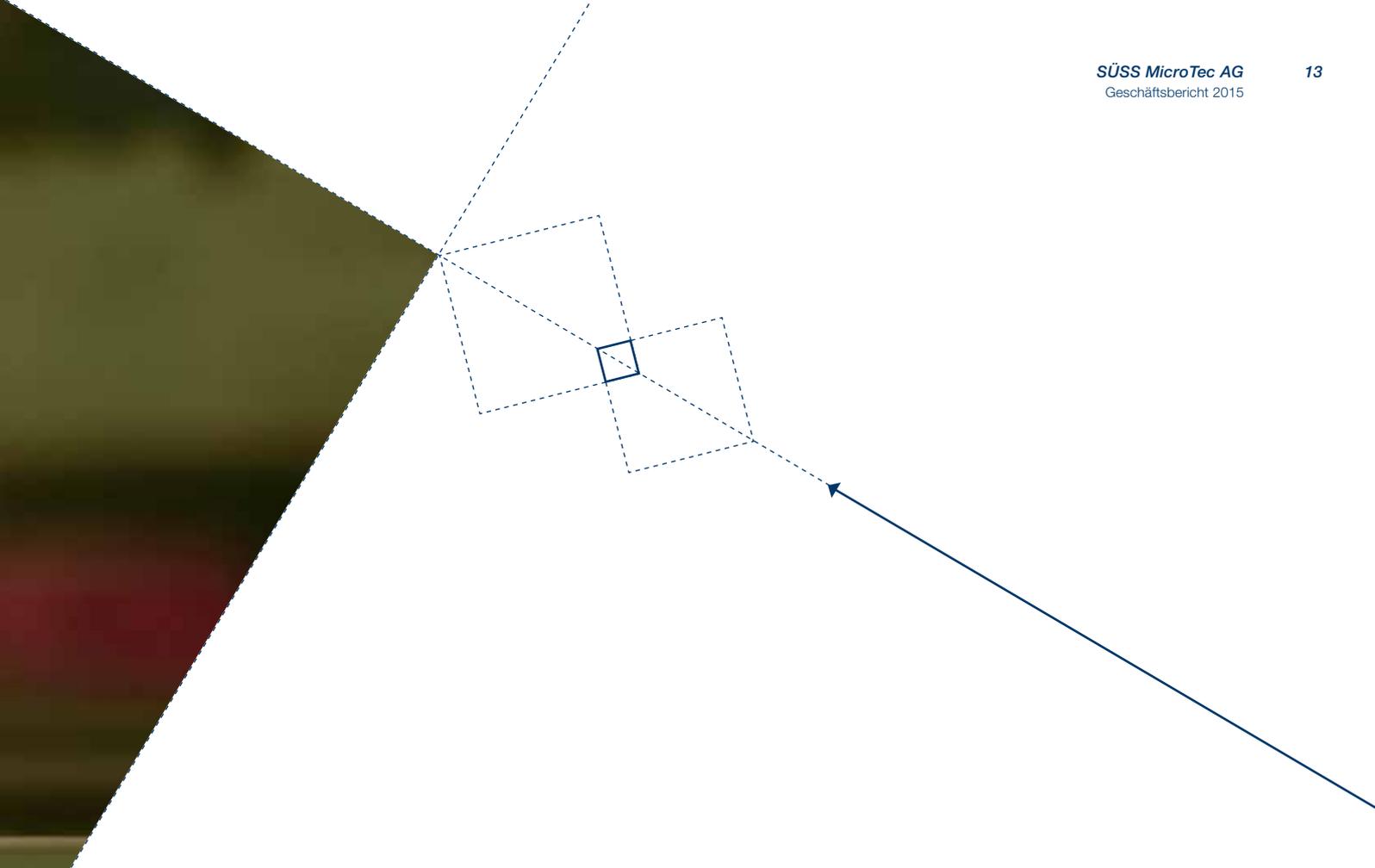
Mit dem Projektionsscanner DSC300 Gen2 haben wir erstmals ein System auf den Markt gebracht, welches die Vorteile der Vollfeldbelichtung mit denen der Projektionslithografie in einem Gerät kombiniert. Im Herbst 2015 ist es uns erstmals gelungen, einen Großauftrag für Projektionsscanner zu gewinnen, welche zukünftig in der Serienproduktion beim Fan-out Wafer-Level Packaging eingesetzt werden.

*Die hochpräzise
Ausrichtung von Wafer
und Maske ist eine
Kernkompetenz des
Mask Aligners*





UV-Projektionscanner vereinen die Vorteile der Vollfeldbelichtung mit denen der Projektionslithografie



ERSTER GROSSAUFTRAG FÜR DIE SERIENFERTIGUNG

Nachfrage nach neuartigen Advanced Packaging Lösungen steigt – Projektions-scanner gewinnen an Bedeutung

Das Advanced Packaging ist seit jeher ein wichtiges Marktsegment für unsere Lithografielösungen. Der Trend zu immer kleiner, dünner und komplexer werdenden mobilen Kommunikationsgeräten erfordert stetig neue Technologien, um kleinste elektronische Bauelemente, wie beispielsweise Speicherchips, möglichst platzsparend in die Endgeräte einzubringen. Mit dem stockenden Voranschreiten von Moores Law sowie der Verschiebung der Serienreife der EUV-Lithografie im Halbleiter-Frontend, gewinnt das Halbleiter-Mid- und Backend zunehmend an Bedeutung. Um die aktuellen Produktlebenszyklen aufrechtzuerhalten wird es zudem immer wichtiger, innovative Packaging-Technologien zu entwickeln und in die Volumenproduktion zu überführen. Zuletzt haben neuartige Packaging-Technologien wie Fan-out Wafer-Level Packaging, Copper-pillar bumping oder die 2,5D-Integration zunehmend an Bedeutung gewonnen, und erste Kundenaufträge mit nennenswertem Volumen wurden platziert.

Unser Projektionsscanner DSC300 Gen2 deckt eine Technologielücke ab, die bisher zwischen dem Mask Aligner und dem Projektionsstepper bestand. Der DSC300 Gen2 bietet vergleichbare Fähigkeiten in Hinblick auf Auflösung und Overlay bei höherem Durchsatz und damit geringere Kosten als herkömmliche Projektionsstepper. Insbesondere beim Fan-out Wafer-Level Packaging, Copper-pillar bumping oder bei der 2,5D-Integration können unsere neuen Systeme die laufenden Kosten durch den Einsatz der Scannertechnologie deutlich senken. Unser Ziel ist es, den Projektionsstepper in möglichst vielen Prozessschritten abzulösen. Im Jahr 2015 konnten wir mit der erfolgreichen Auftragserteilung durch ein führendes Halbleiterunternehmen einen ersten wichtigen Schritt vollziehen. Unser Ziel ist es, unsere Position im Advanced Packaging-Segment weiter auszubauen und auch hier unseren Marktanteil zu erhöhen.



Substrat Bonder

Ein Substrat Bonder verbindet zwei oder mehr äußerst präzise zueinander ausgerichtete Substrate, meist Wafer, durch physikalische und chemische Verfahren permanent oder temporär miteinander. Unser im Herbst 2015 in den Markt eingeführte, halbautomatische Substrat Bonder XB8 ist für eine Vielzahl von permanenten Bondverfahren konzipiert und erlaubt eine Bearbeitung von Substraten mit einem Durchmesser von bis zu 200 mm. Der XB8 Substrat Bonder bietet gegenüber anderen Modellen ein deutlich größeres Parameterfenster und ermöglicht somit die Durchführung aller Bondprozesse. Hierfür sind Bondkraftoptionen von bis zu 100 kN verfügbar sowie ein Temperaturbereich von bis zu 550°C.



RÜCKGEWINNUNG VON MARKTANTEILEN

Neue Impulse für die MEMS-Fertigung

Mit der Markteinführung des XB8 setzen wir unsere Unternehmensstrategie im Hinblick auf die Rückgewinnung von Marktanteilen im Segment Substrat Bonder konsequent um. Das neuartige System kann verschiedene Substratformen und Wafergrößen prozessieren. Durch das gleichzeitige Bonden von bis zu acht Wafern ermöglicht ein Multi-Bond Fixture eine größtmögliche Durchsatzsteigerung. Dies ist insbesondere für die Anwendung in den Märkten für MEMS und LED sowie der 3D-Integration von Bedeutung.

Während der LED-Markt für uns derzeit von geringerer Bedeutung ist, entwickelte sich der MEMS-Markt (Markt für Mikroelektromechanische Systeme bzw. Sensoren) in den letzten Jahren sehr dynamisch. Wie wir einkaufen, wie wir Musik hören, uns fortbewegen oder unseren Haushalt organisieren – Entwicklungen wie Internet of Things, Digitalisierung, Vernetzung und mobile Kommunikation – verändern unser

Leben. Dabei sind diese Themen nicht mehr nur auf den PC oder den Mobilfunk beschränkt, sondern alltägliche Gegenstände beginnen mit uns zu kommunizieren, Daten zu erfassen, zu speichern und auszuwerten sowie auf dieser Datenbasis Entscheidungen zu treffen. Kleinste elektronische Bausteine, unter anderem auch MEMS-Sensoren, sind für diese Entwicklung verantwortlich. Die Stückzahlen steigen seit Jahren durchschnittlich um mehr als zehn Prozent (Yole Développement) und ein Ende dieses Trends ist derzeit nicht absehbar. Mit unseren Lithografie-lösungen, den Belackern und Entwicklern sowie den Mask Alignern profitieren wir bereits von dieser Entwicklung, zukünftig sollen auch unsere Substrat Bonder, insbesondere der XB8, noch stärker in diesem Marktsegment verankert werden und zum profitablen Umsatzwachstum beitragen.



Der XB8 ist ein Universalgerät für Wafer-Bondprozesse mit hoher Bondkraft

Belacker und Entwickler

Mit unseren Lithografielösungen im Bereich Nasschemie sind wir seit Jahren ein führender Anbieter im Halbleiter-Mid- und Backend. Wir bieten unseren Kunden eine umfassende Produktpalette aus Spin- und Sprühbelackern, die vom preiswerten Laborgerät für kleinvolumige Anwendungen bis hin zur hochleistungsfähigen Produktionsanlage reicht. Unsere Belacker und Entwickler ermöglichen das Aufbringen und Strukturieren von Fotolackschichten von unter 1 µm bis über 500 µm. Diese Maschinen finden einen vielseitigen Einsatz, beispielsweise bei der Herstellung von MEMS, im Advanced Packaging sowie der LED-Fertigung.



ACS300 Gen2: Der Einsatz eines neuen Roboters ermöglicht deutliche Durchsatzsteigerungen

ERSTE MARKTERFOLGE BEI ASIATISCHEN KUNDEN

Erfolgreicher Ausbau von Marktanteilen

In den Jahren 2012, 2013 und Anfang 2014 haben wir Marktanteile sowohl bei den Belackern als auch den Entwicklern eingebüßt. Die Gründe hierfür waren eine deutliche Erhöhung der Wettbewerbsintensität durch den Eintritt neuer Anbieter bei einer gleichzeitig ungünstigen Wechselkursentwicklung im Hinblick auf bestehende Wettbewerber. Zudem haben wir die Neu- und Weiterentwicklung einzelner Maschinen nicht immer fokussiert und schnell genug vorangetrieben. Dies wurde erkannt und der strategische Fokus angepasst. Es wird seither mit Hochdruck an der Weiterentwicklung der Maschinen gearbeitet. Im Geschäftsjahr 2015 konnten bereits erste Erfolge der strategischen Fokussierung verzeichnet werden.

Es ist uns gelungen, insbesondere bei den 300 mm Produktionsgeräten, verlorene Marktanteile bei wichtigen asiatischen Kunden zurückzugewinnen. Unser nächstes strategisches Ziel ist die Fortführung der Innovationsoffensive, eine weitere Verbesserung bestehender Produkte und Lösungen sowie die Entwicklung neuer Maschinengenerationen. Darüber hinaus wollen wir unseren Marktanteil, insbesondere bei MEMS und Advanced Packaging-Anwendungen weiter vergrößern, um auch mit den Belackern und Entwicklern zum profitablen Unternehmenswachstum beizutragen.



Bericht des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat möchte Sie, sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, im nachfolgenden Bericht über seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2015 informieren.

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

Der Aufsichtsrat ist seinen gesetzlichen Verpflichtungen sowie den in Geschäftsordnung und Satzung verankerten Aufgaben nachgekommen und hat den Vorstand im abgelaufenen Geschäftsjahr bei der Leitung des Unternehmens beraten und seine Tätigkeit überwacht. In alle Entscheidungen von grundlegender Bedeutung für das Unternehmen war der Aufsichtsrat eingebunden. Der Vorstand stimmte die strategische Ausrichtung des Unternehmens mit dem Aufsichtsrat ab und unterrichtete ihn regelmäßig schriftlich und auch mündlich, zeitnah und umfassend, über die Unternehmensplanung, den Gang der Geschäfte sowie die aktuelle Lage des Konzerns. Abweichungen des Geschäftsverlaufs von der Planung wurden im Einzelnen erläutert und vom Aufsichtsrat anhand der erhaltenen Unterlagen und Informationen überprüft. Bedeutende Geschäftsvorgänge hat der Aufsichtsrat mit dem Vorstand ausführlich erörtert, zu zustimmungspflichtigen Geschäften hat der Aufsichtsrat seine Zustimmung erteilt. Im Geschäftsjahr 2015 fanden insgesamt sechs ordentliche Sitzungen des Aufsichtsrats statt.

Wie auch in den vorangegangenen Jahren stand der Aufsichtsratsvorsitzende über die Aufsichtsratssitzungen hinaus mit dem Vorstand in engem Kontakt und hat sich über die aktuelle Entwicklung der Geschäftslage und die wesentlichen Geschäftsvorfälle informiert. Im ganz besonderen Fokus der Kommunikation stand zudem die Begleitung der Entwicklung einer Wachstumsstrategie für das Unternehmen. Darüber hinaus stand der stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats im regelmäßigen Austausch mit dem Vorstand und den Jahresabschlussprüfern, der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Sitz in Hamburg, Zweigniederlassung München, zu Themen der Rechnungslegung und Jahresabschlussprüfung.

Sitzungen und Beratungsschwerpunkte

Die Geschäftsentwicklung, die Finanzlage und die strategische Ausrichtung der SÜSS MicroTec AG, ihrer Tochtergesellschaften und des Konzerns wurden im Aufsichtsrat regelmäßig erörtert.



Dr. Stefan Reineck, Aufsichtsratsvorsitzender

Der Vorstand unterrichtete umfassend über die Unternehmensplanung, die strategische Weichenstellung und die Entwicklung bei Auftragseingang, Umsatz, Liquidität und Ergebnis. Der Aufsichtsrat hat sich darüber hinaus mit der Überwachung des Rechnungslegungsprozesses sowie der Wirksamkeit des internen Kontrollsystems, des Risikomanagementsystems und der Unabhängigkeit des Abschlussprüfers befasst. Im Folgenden wird auf die Schwerpunkte der Aufsichtsratssitzungen eingegangen.

Am 11. Februar 2015 fand die erste ordentliche Aufsichtsratssitzung des Geschäftsjahres 2015 statt. Hierbei befasste sich der Aufsichtsrat mit dem Bericht des Vorstands zum vierten Quartal 2014 und zu den vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2014. Über die Planung für das Geschäftsjahr 2015 wurde intensiv diskutiert und Beschluss gefasst. Weiterhin wurden die Ziele und der Bonusplan für den Vorstand für das Geschäftsjahr 2015 erörtert und darüber Beschluss gefasst. In dieser Sitzung wurden zudem die Themen Corporate Governance sowie das Gesetz zur gleichberechtigten Teilhabe von Frauen und Männern

an Führungspositionen in der Privatwirtschaft und im Öffentlichen Dienst diskutiert. Daneben führte der Aufsichtsrat in dieser Sitzung seine Effizienzprüfung gemäß Ziffer 5.6 des Deutschen Corporate Governance-Kodex durch und dokumentierte diese.

An der zweiten Sitzung am 26. März 2015 haben Vertreter des Abschlussprüfers, der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, teilgenommen. Diese berichteten dem Aufsichtsrat über die wesentlichen Ergebnisse ihrer Prüfung des Jahres- und des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2014. Der Abschlussprüfer erläuterte dem Aufsichtsrat die Schwerpunkte der Einzel- und Konzernabschlussprüfung. Den Bericht des Vorstands zum Geschäftsjahr 2014 und zur aktuellen Geschäftslage im ersten Quartal 2015 hat der Aufsichtsrat zur Kenntnis genommen. Der Aufsichtsrat billigte nach eingehender Prüfung den vom Vorstand aufgestellten Jahres- und Konzernabschluss der SÜSS MicroTec AG für das Geschäftsjahr 2014. Außerdem beschloss der Aufsichtsrat seinen Bericht an die Hauptversammlung im Hinblick auf seine Tätigkeit im abgelaufenen Geschäftsjahr 2014. Darüber hinaus genehmigte der Aufsichtsrat die Tagesordnung mit den Beschlussvorschlägen für die Hauptversammlung am 2. Juni 2015. Schließlich befasste sich der Aufsichtsrat mit dem Vorstandsbonus 2014, sowie der Dreijahresplanung 2015 bis 2017. In der Sitzung am 26. März 2015 wurden darüber hinaus die Vorstandsgehälter im Hinblick auf die Anforderungen des Corporate Governance-Kodex diskutiert.

Die dritte ordentliche Aufsichtsratssitzung fand am 6. Mai 2015 statt. Der Aufsichtsrat hat sich mit der aktuellen Geschäftslage, dem Geschäftsverteilungsplan für den Vorstand sowie dem Thema Compliance befasst. Zudem erörterte der Aufsichtsrat die aktuelle Situation der Tochtergesellschaft SÜSS MicroTec Photonic Systems, insbesondere im Hinblick auf deren Finanzlage.

In der Sitzung am 2. Juni 2015, unmittelbar vor der ordentlichen Hauptversammlung, informierte der Vorstand den Aufsichtsrat über die aktuelle Geschäftslage. Gegenstand der Sitzung war darüber hinaus der Zeitplan für die Entwicklung des strategischen Wachstumsplans des Unternehmens. Schließlich verabschiedete der Aufsichtsrat eine Ergänzungsempfehlung der Reiserichtlinie betreffend den Vorstand sowie Führungspersonen des Unternehmens.

Am 7. September 2015 fasste der Aufsichtsrat per Umlaufverfahren Beschluss über die Zielgrößen zum Frauenanteil im Aufsichtsrat und im Vorstand der Gesellschaft.

Am 29. Oktober 2015 fand die fünfte ordentliche Aufsichtsratssitzung statt. In dieser Sitzung berichtete der Vorstand über die aktuelle Geschäftslage im dritten Quartal sowie den Ausblick auf das Gesamtjahr 2015. Schwerpunktthema der Sitzung war darüber hinaus die Überarbeitung der Unternehmensstrategie. Der Vorstand stellte dem Aufsichtsrat einen Zwischenstand zum Wachstumsplan 2016 bis 2018 vor. Darüber hinaus befasste sich der Aufsichtsrat mit der Aktualisierung der Entsprechenserklärung und den Prüfungsschwerpunkten für den Jahres- und Konzernabschluss 2015.

Gegenstand der letzten Sitzung des Geschäftsjahres 2015, die am 16. Dezember 2015 stattfand, waren die aktuelle Geschäftslage sowie die Planung für das Geschäftsjahr 2016 und die langfristige Planung für die Geschäftsjahre 2016 bis 2018. Weiterhin beschäftigte sich der Aufsichtsrat ausführlich mit der Corporate Governance und dabei insbesondere mit der Finalisierung der aktualisierten Entsprechenserklärung nach § 161 AktG, den Zielen und Kriterien für die Besetzung des Aufsichtsrats sowie dem Fraud-Katalog der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Der Aufsichtsrat befasste sich mit dem Risikomanagement des Unternehmens und weiteren Vorstandsangelegenheiten. Zudem erörterte er mit dem Vorstand die Ziele für das Geschäftsjahr 2016 sowie die langfristigen Ziele für den Zeitraum 2016 bis 2018.

Alle Mitglieder des Aufsichtsrats haben an sämtlichen Sitzungen teilgenommen. Soweit es erforderlich war, hat der Aufsichtsrat Beschlüsse im schriftlichen Verfahren gefasst.

Aufsichtsratsmitglied	Sitzungsteilnahme	Persönlich anwesend	Telefonische Teilnahme	Anwesenheit in Prozent
Dr. Stefan Reineck	6/6	ja	–	100%
Jan Teichert	6/6	ja	–	100%
Gerhard Pegam	6/6	ja	–	100%

Ausschüsse

Ausschüsse hat der Aufsichtsrat aufgrund seiner Größe von drei Mitgliedern im Geschäftsjahr 2015 nicht gebildet.

Corporate Governance

Der Aufsichtsrat hat sich im Geschäftsjahr 2015 erneut mit den Inhalten und der Umsetzung des Deutschen Corporate Governance-Kodex befasst. Informationen zur Corporate Governance im Unternehmen sowie der ausführliche Bericht zur Höhe und Struktur der Vergütung von Vorstand und Aufsichtsrat sind im Abschnitt Vergütungsbericht des zusammengefassten Lageberichts auf den Seiten 61 ff. wiedergegeben. Vorstand und Aufsichtsrat haben im Januar 2015 die jährliche Erklärung zum Deutschen Corporate Governance-Kodex gemäß § 161 AktG beschlossen und diese den Aktionären auf der Internetseite der Gesellschaft dauerhaft zugänglich gemacht.

In seiner Sitzung vom 11. Februar 2015 führte der Aufsichtsrat seine Effizienzprüfung gemäß Ziffer 5.6 des Deutschen Corporate Governance-Kodex durch und dokumentierte diese. Dabei konnten keine Defizite festgestellt werden. Die Überprüfung der Effizienz der Aufsichtsratsstätigkeit findet in regelmäßigen Abständen durch sämtliche Mitglieder des Aufsichtsrats einzeln im Plenum mit Unterstützung von unternehmensspezifischen Frage- und Checklisten statt.

Interessenkonflikte von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern, die dem Aufsichtsrat gegenüber offen zu legen wären und über die die Hauptversammlung zu informieren wäre, lagen im Geschäftsjahr 2015 nicht vor.

Jahres- und Konzernabschlussprüfung

Die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Sitz in Hamburg, Zweigniederlassung München, hat den nach den Vorschriften des HGB aufgestellten Jahresabschluss und den Lagebericht der SÜSS MicroTec AG zum 31. Dezember 2015 sowie den Konzernabschluss und Konzernlagebericht zum 31. Dezember 2015 geprüft und jeweils mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der Konzernabschluss und der Konzernlagebericht wurden gemäß § 315 a HGB auf der Grundlage der internationalen Rechnungslegungsstandards IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, aufgestellt. Der Abschlussprüfer hat die Prüfung unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsgemäßer Abschlussprüfung vorgenommen.

Die Prüfungsberichte der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Sitz in Hamburg, Zweigniederlassung München, lagen allen Mitgliedern des Aufsichtsrats vor und wurden in der Bilanzsitzung des Aufsichtsrats am 29. März 2016 in Gegenwart des Abschlussprüfers umfassend behandelt. Der Abschlussprüfer berichtete über die wesentlichen Ergebnisse seiner Prüfung sowie darüber, dass keine wesentlichen Schwächen des internen Kontrollsystems und des Risikomanagementsystems vorlägen. Insbesondere hat er Erläuterungen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft und des Konzerns abgegeben und hat dem Aufsichtsrat für ergänzende Auskünfte zur Verfügung gestanden. Der Abschlussprüfer ging ferner auf Umfang, Schwerpunkte und Kosten der Abschlussprüfung ein. Schwerpunkte der diesjährigen Jahres- und Konzernabschlussprüfung bildeten das interne Kontroll- und IT-System sowie unter anderem die Beurteilung der Werthaltigkeit von Vermögenswerten in dem Geschäftsfeld Lithografie, insbesondere im Zusammenhang mit der Tätigkeit der SÜSS MicroTec Photonic Systems (USA), die Bewertung von latenten Steueransprüchen, die Beurteilung möglicher Risiken aus Planabweichungen und Margenverlusten in einzelnen Produktsegmenten, die Umsatzrealisation, die bilanzielle Behandlung des SAP-Rollouts in Corona bei der SÜSS MicroTec AG sowie die Vollständigkeit und Korrektheit der Anhangsangaben und die Angemessenheit der Lageberichterstattung.

Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss der Gesellschaft und des Konzerns sowie den mit dem Konzernlagebericht zusammengefassten Lagebericht der SÜSS MicroTec AG jeweils für das Geschäftsjahr 2015 geprüft. Der Aufsichtsrat hatte keine Einwände. Die Berichte des Abschlussprüfers hat der Aufsichtsrat nach eingehender Prüfung zustimmend zur Kenntnis genommen.

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss gebilligt und damit festgestellt. Der Aufsichtsrat hat auch den Konzernabschluss gebilligt. Dem gemeinsamen Lagebericht für die AG und den Konzern und insbesondere der Beurteilung der weiteren Entwicklung des Unternehmens hat der Aufsichtsrat zugestimmt.

Besetzung von Vorstand und Aufsichtsrat

Im Geschäftsjahr 2015 gab es eine personelle Änderung im Vorstand. Der Aufsichtsrat hat Herrn Dr. Per-Ove Hansson mit Wirkung zum 1. Mai 2015 für die Dauer von drei Jahren zum Vorstand und Vorstandsvorsitzenden (Chief Executive Officer) der SÜSS MicroTec AG berufen. Daneben gehörten dem Vorstand im Geschäftsjahr 2015 weiterhin der Finanzvorstand Michael Knopp sowie der Produktionsvorstand Walter Braun an.

Der Aufsichtsrat blieb im Geschäftsjahr 2015 unverändert.

Dank

Der Aufsichtsrat spricht dem Vorstand sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern großen Dank und Anerkennung für die tatkräftige Arbeit im abgelaufenen Geschäftsjahr aus.

Garching, 29. März 2016



Dr. Stefan Reineck
Aufsichtsratsvorsitzender

Investor Relations

Nach mehreren Jahren mit einem sehr geringen Neuemissionsvolumen an Aktien, hatte sich der Markt für Börsengänge in Deutschland 2014 erstmals wieder belebt. Im Börsenjahr 2015 gab es insgesamt 15 sogenannte IPOs (Initial Public Offering) mit einem Emissionsvolumen von 7,1 Mrd. Euro; damit lag das Emissionsvolumen nach Angaben der Beratungsgesellschaft Ernst & Young im abgelaufenen Jahr doppelt so hoch wie 2014.

Gemäß des Dezember-Monatsberichts der Deutschen Bundesbank wurde die deutsche Wirtschaft im Geschäftsjahr 2015 überwiegend durch die lebhaftere Binnennachfrage getragen. Insbesondere die gute Arbeitsmarktlage sowie die kräftig gestiegenen Realeinkommen waren die treibenden Faktoren. Die Exporte litten dagegen im gesamten Geschäftsjahr unter der eher verhaltenen Nachfrage, insbesondere aus den Schwellenländern. Neben der anhaltend schwächelnden wirtschaftlichen Entwicklung in China belastete die politische Situation in den zahlreichen Krisengebieten, wie beispielsweise in Syrien, der Türkei oder der Ukraine, die gesamtwirtschaftliche Stimmung. So hat sich der Indikator für den ifo-Weltwirtschaftsklimaindex im vierten Quartal 2015 entsprechend verschlechtert und ist sogar unter seinen langfristigen Durchschnittswert gefallen. Die wirtschaftlichen und politischen Turbulenzen haben deutliche Spuren an den ohnehin volatilen Aktienmärkten hinterlassen.

Ein bewegtes Börsenjahr 2015

Das Börsenjahr 2015 begann mit einem rasanten Höhenflug des Deutschen Leitindex DAX, welcher im April einen neuen Rekordschlusskurs (Xetra) von 12.375 Punkten erreichte. Noch zu Jahresbeginn hatte der Index bei unter 10.000 Punkten gelegen. Eine ähnliche Entwicklung war bei den anderen Auswahlindizes der Deutschen Börse, dem MDAX, SDAX und TecDAX zu verzeichnen, alle Indices erreichten im Börsenjahr 2015 neue Höchststände. Nachdem sich im Sommer 2015 die akute Schuldenkrise in Griechenland durch ein weiteres Hilfspaket vorerst entspannt hatte, stellten das deutlich verlangsamte Wirtschaftswachstum in China sowie der anhaltend niedrige Ölpreis wichtige Gründe für die Turbulenzen an den Weltbörsen im zweiten Halbjahr 2015 dar. Wuchs die chinesische Wirtschaft im Geschäftsjahr 2014 noch um 7,4 Prozent, so waren es im ersten Halbjahr 2015 gemäß den Schätzungen des ifw Kiel nur 3,1 Prozent. Noch im Dezember 2015 hielt die chinesische Regierung an ihrem Wirtschaftswachstumsziel von 7 Prozent fest, wobei verschiedene Ökonomen bereits von

einem verlangsamten Wachstum von 6,7 bis 6,9 Prozent ausgingen. Am Aktienmarkt konnten die Indices entsprechend ihre Rekordstände nicht verteidigen und haben das Geschäftsjahr mit Werten von 10.743,01 Punkten im DAX sowie mit 1.830,74 Zählern im TecDAX geschlossen.

Die SÜSS MicroTec-Aktie

Analog zur Entwicklung der Börsenindices konnte auch die SÜSS MicroTec-Aktie ein gutes erstes Halbjahr 2015 verbuchen. Gegenüber dem Xetra-Schlusskurs zum Jahresanfang in Höhe von 4,88 Euro konnte die Aktie zum Ende des ersten Halbjahres um rund 4,1 Prozent auf 5,08 Euro zulegen. Getrübt wurde das Börsengeschehen im ersten Halbjahr lediglich durch die Situation in der Ukraine und das angespannte Verhältnis zu Russland. Zum Ende des zweiten Quartals prägten Diskussionen über die sich zuspitzende Schuldensituation in Griechenland und um einen möglichen Ausstieg aus der Eurozone das wirtschaftliche Tagesgeschehen. Die Börsen reagierten teilweise mit heftigen Kursbewegungen auf die Situation in Griechenland. Das dritte Quartal beendete die SÜSS MicroTec-Aktie in einem schwierigen Börsenumfeld mit einem Schlusskurs von 5,65 Euro, dies entspricht einem Plus von rund 16 Prozent gegenüber Jahresanfang. Die Hauptgründe für die positive Entwicklung waren die Erhöhung der Umsatzerwartung für das Gesamtjahr 2015 sowie die Aussicht auf ein leicht positives Ergebnis (EBIT). Zudem hatte sich der Auftragseingang besser als erwartet entwickelt, und das Unternehmen konnte die Auftragseingangsguidance für das dritte Quartal anheben. Darüber hinaus war es SÜSS MicroTec im dritten Quartal gelungen, einen wichtigen Auftrag für neuartige Scannersysteme zu gewinnen. Im letzten Quartal des Geschäftsjahres 2015 setzte sich die positive Entwicklung fort und SÜSS MicroTec konnte die Schätzungen für den Auftragseingang im laufenden Quartal mehrmals von ursprünglich 30 bis 40 Mio. Euro auf zunächst 35 bis 45 Mio. Euro und in einem zweiten und dritten Schritt auf 50 bis 60 Mio. Euro bzw. zuletzt auf einen Wert von mindestens 65 Mio. Euro anheben.

Die Erhöhung des Ausblicks für das vierte Quartal beflügelte den Kurs der SÜSS MicroTec-Aktie enorm. Die Aktie stieg allein im vierten Quartal 2015 von anfangs 5,59 Euro um fast 50 Prozent. Zum Jahresende notierte die Aktie entsprechend bei 8,35 Euro, dies entspricht einem Plus von rund 77,7 Prozent gegenüber dem Jahresanfang. Der Vergleichsindex TecDAX erhöhte sich im gleichen Zeitraum um 33,5 Prozent auf 1830,74 Punkte.

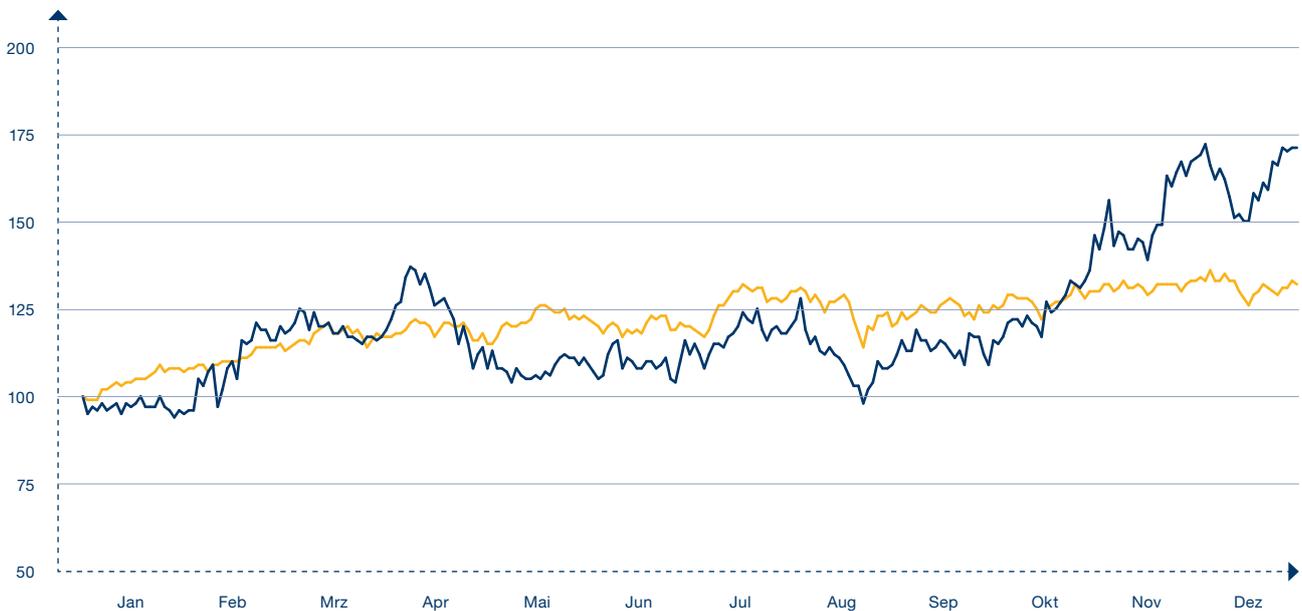
Die Anzahl der im Tagesdurchschnitt am Börsenplatz Frankfurt und über Xetra gehandelten SÜSS MicroTec-Aktien lag im Jahr 2015 bei 129.144 Stück (Vorjahr: durchschnittlich 114.596 Aktien pro Tag).

Einen Überblick über den Kursverlauf im Jahr 2015 im Vergleich zum TecDAX bietet die folgende grafische Darstellung.

Kursentwicklung der SÜSS MicroTec-Aktie im Jahr 2015

Schlusskurs der SÜSS MicroTec-Aktie am 2. Januar 2015: 4,88 €

— SÜSS MicroTec AG, indiziert — TecDAX, indiziert



Vergleich der Kursentwicklung von SÜSS MicroTec und TecDAX im Geschäftsjahr 2015

	30.12.2015	30.12.2014	Veränderungen
TecDAX (in Punkten)	1.830,74	1.371	+33,5 %
SÜSS MicroTec (in €)	8,35	4,70	+77,7 %

Die SÜSS MicroTec-Aktie im Überblick

Wertpapierkennnummer	A1K023
ISIN	DE000A1K0235
Reuters-Kürzel	SMHN
Bloomberg-Kürzel	SMHN:GR
Börsensegment	Prime Standard
Anzahl der ausgegebenen Aktien (Stand 31.12.2015)	19.115.538
Wertpapiergattung	Namensaktien
Designated Sponsor zum 31.12.2015	equinet Bank AG
Beginn der Börsennotierung	18.05.1999
Jahresanfangs- / -schlusskurs in €	4,88 € / 8,35 €
Jahreshoch- / tief in € ¹	8,39 € / 4,56 €

¹ Xetra-Schlusskurs

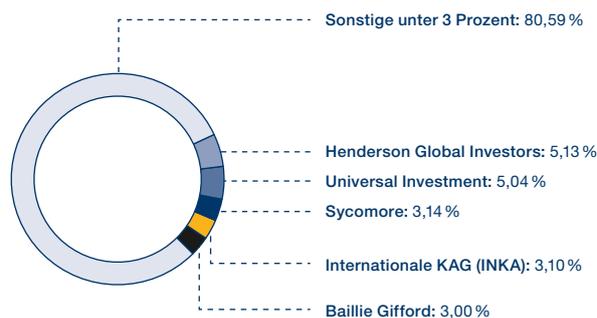
Investor Relations-Aktivitäten

Investor Relations umfasst alle Maßnahmen, die der Pflege der Beziehungen eines börsennotierten Unternehmens zu den Investoren dienen. Es geht bei der Investor Relations-Arbeit unter anderem darum, den Kapitalmarkt zeitnah mit aktuellen Informationen über das Unternehmen zu versorgen und somit eine angemessene Bewertung der Aktie an der Börse zu gewährleisten. Zu den Kapitalmarktteilnehmern und damit zu den direkten Ansprechpartnern gehören beispielsweise Privataktionäre, Fondsmanager, Finanzanalysten in Bankhäusern und natürlich auch die Finanzpresse.

Vorstand und Investor Relations besuchten im Börsenjahr 2015 fünf Kapitalmarkttagungen und absolvierten mehrere Roadshows. Die Kapitalmarkttagungen fanden in München, Frankfurt und Zürich statt. Zusätzlich dazu wurde in vielen Einzelgesprächen die Gelegenheit zum persönlichen Austausch mit institutionellen Investoren und Analysten genutzt. Anlässlich der Veröffentlichung von Quartalsergebnissen fanden Telefonkonferenzen für Investoren und Analysten statt.

Im Jahr 2015 gab es nennenswerte Veränderungen in der Aktionärsstruktur. Schroders, der Vanguard Whitehall Fund sowie die ING Investment Management haben einen Anteil von unter drei Prozent gemeldet. Dagegen haben Universal Investment und die Internationale KAG (INKA) im Jahresverlauf einen Anteilsbesitz von jeweils 5,04 Prozent und 3,1 Prozent gemeldet. Baillie Gifford und Henderson Global Investors haben ihre Positionen im Börsenjahr 2015 nicht verändert. Der Streubesitz beträgt zum Jahresende 2015 weiterhin 100 Prozent.

Aktionärsstruktur zum 31. Dezember 2015



Analystenempfehlungen weiterhin positiv

Zum Jahresende 2015 wurde das Unternehmen von insgesamt zehn Banken und Research-Häusern gecovert. Stand Dezember 2015 haben sechs von zehn Analysten eine Kaufempfehlung für die SÜSS MicroTec-Aktie ausgesprochen, daneben gaben zwei Analysten die Empfehlung zum Halten der Aktie, und ein Analyst empfahl die Aktie zu akkumulieren. Zum Jahresende lag zudem eine Verkaufsempfehlung der DZ Bank vor. Eine Übersicht über die Research-Studien zur SÜSS MicroTec-Aktie finden Sie im Internet unter ► www.suss.com ► [Investor Relations](#).

Hauptversammlung

Am 2. Juni 2015 fand die ordentliche Hauptversammlung im Haus der Bayerischen Wirtschaft in München statt. Insgesamt waren über 80 Aktionäre, Aktionärs- und Bankenvertreter sowie Gäste der Einladung des Unternehmens nach München gefolgt. Damit waren 25,38 Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft anwesend. Neben der Entscheidung über die Entlastung des Vorstands sowie des Aufsichtsrats wurde über die Bestellung des Abschlussprüfers sowie eine Erhöhung der Vergütung für den Aufsichtsrat abgestimmt. Die Aktionäre des Unternehmens gaben ihre Zustimmung zu allen Beschlussvorlagen, die Vorstand und Aufsichtsrat auf der diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung präsentierten.

Der Finanzvorstand und damalige Vorstandssprecher Michael Knopp erläuterte in seinem Bericht die wesentlichen Entwicklungen und Ergebnisse des Geschäftsjahres 2014 sowie des ersten Quartals 2015 und bestätigte den Ausblick für das Gesamtjahr 2015.

Corporate Governance

Corporate Governance steht für eine verantwortungsbewusste und auf langfristige Wertschöpfung ausgerichtete Führung und Kontrolle von Unternehmen. Daneben gehören für SÜSS MicroTec Transparenz, eine offene Kommunikation mit Aktionären und Investoren sowie eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Aufsichtsrat und Vorstand zu den wesentlichen Aspekten einer guten Corporate Governance. SÜSS MicroTec orientiert sich am Deutschen Corporate Governance-Kodex (DCGK), der sich als Maßstab guter Unternehmensführung in Deutschland bewährt hat. Einzelheiten hierzu finden Sie in dem nachfolgenden Bericht.

Corporate Governance im Überblick

Mit der Zielsetzung, durch eine verantwortungsbewusste und langfristig ausgerichtete Unternehmensführung nicht nur den Fortbestand des Unternehmens, sondern auch eine nachhaltige Steigerung des Unternehmenswertes zu erreichen, hat die Corporate Governance einen hohen Stellenwert im Unternehmen. Vorstand und Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec AG haben sich im Geschäftsjahr 2015 erneut intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt. SÜSS MicroTec strebt in seinem unternehmerischen Handeln danach, das Vertrauen, das uns Anleger, Finanzmärkte, Geschäftspartner, Mitarbeiter und die Öffentlichkeit entgegenbringen, zu bestätigen und die Corporate Governance im Konzern fortlaufend weiterzuentwickeln. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie auch auf unserer Website unter ► www.suss.com ► [Investor Relations](#) ► [Corporate Governance](#).

Entsprechenserklärung zum Deutschen Corporate Governance-Kodex

Vorstand und Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec AG haben am 7. Januar 2016 gem. § 161 Abs. 1 AktG folgende Entsprechenserklärung abgegeben:

Die SÜSS MicroTec AG wird den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance-Kodex in der Fassung vom 5. Mai 2015 mit den nachfolgend aufgelisteten Ausnahmen entsprechen und hat den Empfehlungen des Kodex in der Fassung vom 24. Juni 2014 seit der Abgabe der letzten jährlichen Entsprechenserklärung im Januar 2015 mit den darin angegebenen Ausnahmen entsprochen.

SELBSTBEHALT BEI D&O-VERSICHERUNGEN

Der Deutsche Corporate Governance-Kodex empfiehlt in Ziffer 3.8 Abs. 3 bei Abschluss einer D&O-Versicherung (Vermögensschadenshaftpflichtversicherung) einen der gesetzlichen Regelung für Vorstände entsprechenden Selbstbehalt für den Aufsichtsrat der Gesellschaft zu vereinbaren. Die SÜSS MicroTec AG verfügt bereits seit mehreren Jahren über eine D&O-Versicherung ohne organspezifischen Selbstbehalt für den Aufsichtsrat. Das verantwortungsvolle Handeln des Aufsichtsrats wird nach Ansicht von SÜSS MicroTec durch Vereinbarung eines entsprechenden Selbstbehalts nicht zusätzlich gefördert.

VERTIKALER VERGÜTUNGSVERGLEICH

In Ziffer 4.2.2 Abs. 2 Satz 3 empfiehlt der Deutsche Corporate Governance-Kodex dem Aufsichtsrat bei der Festlegung der Vorstandsvergütung das Verhältnis der Vorstandsvergütung zur Vergütung des oberen Führungskreises sowie der Belegschaft insgesamt auch in der zeitlichen Entwicklung zu berücksichtigen, wobei der Aufsichtsrat festlegt, wie der obere Führungskreis und die relevante Belegschaft abzugrenzen ist.

Der Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec AG ist der Auffassung, dass die Festlegung des oberen Führungskreises und der relevanten Belegschaft unter Einbeziehung der zeitlichen Entwicklung in der Praxis zu erheblichen Rechtsunsicherheiten führen kann. Die SÜSS MicroTec AG erklärt daher insoweit vorsorglich eine Kodexabweichung.

VERSORGUNGSZUSAGEN

Unter Ziffer 4.2.3 Abs. 3 empfiehlt der Deutsche Corporate Governance-Kodex dem Aufsichtsrat, bei Versorgungszusagen das jeweils angestrebte Versorgungsniveau – auch nach der Dauer der Vorstandszugehörigkeit – und den daraus abgeleiteten jährlichen sowie langfristigen Aufwand für das Unternehmen zu berücksichtigen.

Der Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec weicht von dieser Empfehlung ab, da für die Vorstandsmitglieder kein bestimmtes „Versorgungsniveau“ im Ruhestand, sondern eine markt- und unternehmenskonforme Vergütung der aktiven Tätigkeit angestrebt wird. Unmittelbare Versorgungszusagen, bei denen die Gesellschaft selbst die zugesagten Leistungen erbringt, werden den Mitgliedern des Vorstands grundsätzlich nicht gewährt. Soweit die Gesellschaft den Vorstandsmitgliedern einen Zuschuss zur Altersvorsorge gewährt und Beiträge in eine Direktversicherung (Kapitallebens- bzw. Rentenversicherung) einzahlt, ist damit keine Zusage eines bestimmten Versorgungsniveaus verbunden.

BILDUNG VON AUSSCHÜSSEN

Der Deutsche Corporate Governance-Kodex empfiehlt in Ziffer 5.3 in Abhängigkeit von den spezifischen Gegebenheiten des Unternehmens und der Anzahl seiner Aufsichtsratsmitglieder die Bildung von fachlich qualifizierten Ausschüssen. Da der Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec nur aus drei Aufsichtsratsmitgliedern besteht, ist die Bildung von Ausschüssen, die im Regelfall aus mindestens drei Mitgliedern bestehen müssen, nicht möglich und im Übrigen auch nicht erforderlich, da im Plenum eine intensive und qualifizierte Diskussion stattfinden kann.

FESTLEGUNG EINER REGELGRENZE FÜR DIE ZUGEHÖRIGKEITSDAUER IM AUFSICHTSRAT

Entsprechend Ziffer 5.4.1 Abs. 2 des Deutschen Corporate Governance-Kodex soll der Aufsichtsrat eine Regelgrenze für die Zugehörigkeitsdauer im Aufsichtsrat festlegen. Der Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec AG weicht von dieser Empfehlung ab, da die Festlegung einer Regelzugehörigkeitsgrenze den Handlungsspielraum sowie die Kompetenz des Aufsichtsrats gefährden könnte. Das unabhängige und verantwortungsvolle Handeln des Aufsichtsrats wird nach Ansicht von SÜSS MicroTec nicht durch die Begrenzung der Verweildauer im Aufsichtsrat gefördert. Im Gegenteil, durch die komplexe Produkt- und Unternehmensstruktur ist eine gewisse Verweildauer im Aufsichtsrat eher positiv zu sehen, da im Zeitverlauf wertvolle, unternehmensspezifische Erfahrungen und Erkenntnisse gesammelt werden, die zum Wohl des Unternehmens eingesetzt werden können.

Kommunikation und Transparenz

Die Unternehmenskommunikation bei SÜSS MicroTec verfolgt den Anspruch, alle Zielgruppen gleichberechtigt und zeitnah zu informieren, und dabei größtmögliche Transparenz und Chancengleichheit für alle Kapitalmarktteilnehmer zu gewährleisten. Dazu nutzt das Unternehmen neben Quartals-, Halbjahres- und Jahresberichten die Möglichkeit von Telefongesprächen, Konferenzen und Roadshows sowie die Website, um Aktionäre, institutionelle Investoren, Analysten und sonstige Interessierte über

Entwicklungen im Konzern zu informieren. SÜSS MicroTec unterrichtet seine Aktionäre im Wesentlichen vier Mal im Jahr über die Geschäftsentwicklung sowie über die aktuelle Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Sie können unter ► www.suss.com ► **Investor Relations** neben allen Pflichtpublikationen, die dort in deutscher und englischer Sprache zum Download bereit gestellt sind, Präsentationen wesentlicher Veranstaltungen sowie Vorstandsideinterviews im Video- oder Audioformat frei einsehen bzw. abrufen.

Über die wiederkehrenden Termine wie den Termin der Hauptversammlung oder die Veröffentlichungszeitpunkte der Zwischenberichte unterrichten wir die Öffentlichkeit zeitnah und regelmäßig in einem Finanzkalender, der im Geschäftsbericht, in den Zwischenberichten sowie auf der Website unserer Gesellschaft veröffentlicht ist.

Hauptversammlung

Auf der Hauptversammlung der SÜSS MicroTec AG können sich unsere Aktionäre mit Fragen zum Unternehmen und zum Geschäftsverlauf direkt an Vorstand und Aufsichtsrat wenden. Wir bereiten die Hauptversammlung stets mit dem Ziel vor, den Aktionären alle für sie relevanten Informationen zur Verfügung zu stellen. Die Hauptversammlung beschließt darüber hinaus unter anderem über die Gewinnverwendung, die Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats sowie über die Wahl des Abschlussprüfers.

Die Einberufung der Hauptversammlung mit den anstehenden Tagesordnungspunkten sowie die Erläuterung der Teilnahmebedingungen werden in der Regel fünf bis sechs Wochen vor dem Hauptversammlungstermin bekannt gemacht. Alle Dokumente und Informationen zur Hauptversammlung stehen auf der Website der Gesellschaft zum Download zur Verfügung und können ebenfalls in Kopie bei der Investor Relations-Abteilung angefordert werden. Zudem sind wir bemüht, unseren Aktionären die Ausübung ihrer Rechte zu erleichtern. Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung entweder selbst ausüben oder durch einen Bevollmächtigten ihrer Wahl oder durch einen weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausüben lassen. Die Weisungen zur Stimmrechtsausübung können vor oder während der Hauptversammlung direkt vor Ort erteilt werden. Die Präsenz und die Abstimmungsergebnisse zur Hauptversammlung veröffentlichen wir direkt im Anschluss an die Veranstaltung im Internet.

Zusammenarbeit von Vorstand und Aufsichtsrat

Als Aktiengesellschaft (AG) unterliegt SÜSS MicroTec dem deutschen Aktienrecht und verfügt daher über eine zweigeteilte Führungs- und Kontrollstruktur, die von den Mitgliedern des Vorstands und den Mitgliedern des Aufsichtsrats wahrgenommen wird. Vorstand und Aufsichtsrat arbeiten zielgerichtet und effizient zusammen, um – unter Beachtung der Interessen unserer Mitarbeiter und unserer Aktionäre – eine nachhaltige Wertsteigerung des Unternehmens voranzutreiben. Die Mitglieder des Vorstands tragen gemeinsam die Verantwortung für die gesamte Geschäftsführung. Ihnen obliegt die Entwicklung der strategischen Ausrichtung des Unternehmens, sie stimmen diese mit dem Aufsichtsrat ab und sorgen für deren verantwortungsvolle Umsetzung.

Der Aufsichtsrat überwacht und berät den Vorstand bei der Führung der Geschäfte und bestellt die Vorstandsmitglieder. Wesentliche Vorstandsentscheidungen – z. B. Akquisitionen, Desinvestitionen und Finanzmaßnahmen – sind an die Zustimmung des Aufsichtsrats gebunden. Der Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec AG ist nicht mitbestimmt, und es wurden keine Ausschüsse gebildet, daher ist über die Zusammensetzung und Arbeitsweise der Ausschüsse nicht zu berichten.

Vorstand und Aufsichtsrat arbeiten im Interesse des Unternehmens und mit dem gemeinsamen Ziel, den Unternehmenswert nachhaltig zu steigern, stets sehr eng zusammen. Der Vorstand informiert den Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend über die Geschäftspolitik sowie über alle für das Unternehmen relevanten Fragen der Planung, der Geschäftsentwicklung, der Risikolage und des Risikomanagements. Abweichungen des Geschäftsverlaufs von den aufgestellten Plänen und Zielen werden dabei erläutert und begründet.

Wie es der Deutsche Corporate Governance-Kodex vorsieht, gehört dem Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec AG mit Dr. Stefan Reineck nicht mehr als ein ehemaliges Vorstandsmitglied an. Berater- oder sonstige Dienstleistungs- und Werkverträge zwischen Aufsichtsratsmitgliedern und der Gesellschaft bestanden auch im Berichtsjahr 2015 nicht. Interessenkonflikte von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern, die dem Aufsichtsrat unverzüglich offenzulegen sind, traten im Geschäftsjahr 2015 nicht auf.

Ziele des Aufsichtsrats hinsichtlich seiner Zusammensetzung

Ziel der Zusammensetzung des Aufsichtsrates der SÜSS MicroTec AG ist es, die Unternehmensentwicklung zu nachhaltiger Ertragskraft und permanenter Anpassung an sich schnell wandelnde Anforderungen durch konstruktive Beratung und Überwachung des Vorstandes auf der Basis relevanter Kompetenzen abzusichern. Durch eine ausreichende Kompetenzvielfalt der Mitglieder sollen ein breites Erfahrungsspektrum und unterschiedliche Sichtweisen zum Nutzen des Unternehmens eingebracht werden.

Die SÜSS MicroTec AG ist ein auf den Weltmarkt ausgerichtetes, technologieorientiertes Unternehmen, das sich in einem sehr dynamischen und technologisch anspruchsvollen Umfeld behaupten und entwickeln muss. Daher sind im Aufsichtsrat technologisches Beurteilungsvermögen und einschlägige Marktkenntnisse im internationalen Maßstab erforderlich. Folglich ist es das Ziel des Aufsichtsrates, neben dem Financial Expert erfahrene Persönlichkeiten zu gewinnen, die diese Bereiche abdecken. Für die technologische Expertise sind relevante Kenntnisse der Halbleiter- und halbleiternahen Industrie sowie deren Equipment-Industrie von besonderer Bedeutung. Um Trends und Entwicklungen in unseren sehr dynamischen Märkten vorausschauend und zuverlässig beurteilen zu können, sollten im Aufsichtsrat internationale Erfahrung und möglichst aktive Verbindungen vertreten sein.

Zusätzlich zu diesen genannten wichtigen Kompetenzen erwartet das Unternehmen von Aufsichtsratsmitgliedern und -kandidaten eine breite Erfahrung in anderen Bereichen, die möglichst ergänzend zu einer optimalen Besetzung des Aufsichtsrates beitragen. Dazu gehören insbesondere Kenntnisse und Erfahrungen bezüglich strategischer Unternehmensentwicklung inkl. Mergers & Acquisitions, des Kapitalmarktes und der Kapitalmarktkommunikation, der Rekrutierung von Führungskräften und moderner Vergütungsmodelle für alle Ebenen sowie eine erhöhte Sensibilität für ökonomisch-ökologische Grundsatzfragen.

Abhängig von der aktuellen Unternehmenssituation kann es sinnvoll sein, die Gewichte der einzelnen Kriterien neu zu bewerten und der Hauptversammlung entsprechende Veränderungen im Aufsichtsrat vorzuschlagen. Dazu beobachtet der Aufsichtsrat die Unternehmenssituation und bewertet die Aufsichtsratsbesetzung in regelmäßigen Abständen.

Die Festlegung einer über die gesetzlichen Anforderungen hinausgehenden Mindestzahl von unabhängigen Aufsichtsratsmitgliedern halten Vorstand und Aufsichtsrat angesichts der

Größe des Aufsichtsrates nicht für sinnvoll, um das künftige Auswahlmessen bei der Besetzung von Aufsichtsratspositionen nicht zu stark einzuschränken.

Der Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec AG wird keine feste Regelzugehörigkeitsdauer für die Aufsichtsratsmitglieder festlegen, da eine solche Festlegung den Handlungsspielraum sowie die Kompetenz des Aufsichtsrates negativ beeinträchtigen könnte. Das unabhängige und verantwortungsvolle Handeln des Aufsichtsrates wird nach Ansicht von SÜSS MicroTec nicht durch die Begrenzung der Verweildauer im Aufsichtsrat gefördert. Durch die komplexe Produkt- und Unternehmensstruktur ist eine gewisse Verweildauer im Aufsichtsrat eher positiv zu sehen, da im Zeitverlauf wertvolle, unternehmensspezifische Erfahrungen und Erkenntnisse gesammelt werden, die zum Wohl des Unternehmens eingesetzt werden können.

SÜSS MicroTec prüft jeden potenziellen Kandidaten für den Aufsichtsrat hinsichtlich seiner Kompetenz und Verfügbarkeit, bevor ein Vorschlag an die Hauptversammlung gemacht wird. Zudem müssen potenzielle Kandidaten vorher eine Funktion als Vorstand, Geschäftsführer oder eine ähnlich verantwortungsvolle Position in einem vergleichbaren oder größeren Unternehmen, bevorzugt nahe unserer Branchen ausüben oder ausgeübt haben. Alternativ können Experten kandidieren, die ein besonderes Wissen und Erfahrungen für unser Unternehmen mitbringen, sofern dies als bedeutsam für den Unternehmenserfolg anzusehen ist. Es gibt jedoch keine feste Bestimmung eines ganz bestimmten Zeitaufwandes, den Aufsichtsratsmitglieder aufzubringen haben. Grundsätzlich nimmt das Unternehmen Abstand von potenziellen Kandidaten, die bereits fünf oder mehr Mandate in Aufsichtsgremien bekleiden und orientiert sich damit auch an Empfehlungen von Stimmrechtsberatern.

Bei der Besetzung des Aufsichtsrates sollen zukünftig Frauen mit größerer Aufmerksamkeit berücksichtigt werden, um eine angemessene Frauenbeteiligung zu erreichen. Zudem sind börsennotierte und/oder mitbestimmungspflichtige Unternehmen seit 2015 gesetzlich verpflichtet, Zielgrößen für die Erhöhung des Frauenanteils u. a. im Aufsichtsrat festzulegen und zu veröffentlichen sowie über deren Stand der Umsetzung zu berichten. Aufsichtsrat und Vorstand der SÜSS MicroTec AG haben im September 2015 festgelegt, dass die zu erreichende Zielgröße für den Frauenanteil im Aufsichtsrat bei 0 Prozent liegt. Zum Zeitpunkt der Festlegung dieser Zielgrößen war keine Frau im Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec AG tätig. Aus Sicht der SÜSS MicroTec AG ist die Qualifikation von den Aufsichtsratskandidaten maßgebliches Kriterium für die Übernahme eines Aufsichtsratsmandats und damit die Zusammensetzung des Aufsichtsrates. Bei den Vorschlägen für die Zusammensetzung des Aufsichtsrates

unterstützt und berücksichtigt SÜSS MicroTec die im DCGK genannten Kriterien, sieht aber speziell in der Halbleiter-Branche die Erfüllung einer bestimmten Quote für den Frauenanteil als problematisch an.

Die Altersgrenze für Aufsichtsratsmitglieder liegt bei 71 Jahren.

Interessenkonflikte werden bei der Besetzung des Aufsichtsrates vermieden, indem die Kandidaten bereits im Vorfeld einer Wahl Negativerklärungen abgeben. Sollte es während einer Wahlperiode zu potenziellen oder tatsächlichen Konflikten kommen, dann führen entsprechende Regelungen für Aufsichtsrat und Vorstand zu deren Offenlegung und zu einer angemessenen Behandlung im Plenum des Aufsichtsrates.

Festlegungen zur Förderung der Teilhabe von Frauen an Führungspositionen

Durch das am 1. Mai 2015 in Kraft getretene „Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst“ (§ 76 Abs. 4 und § 111 Abs. 5 des AktG) sind börsennotierte Gesellschaften wie die SÜSS MicroTec AG unter anderem verpflichtet worden, erstmals Zielgrößen für den Frauenanteil in Aufsichtsrat, Vorstand und den nachfolgenden zwei Führungsebenen festzulegen. Darüber hinaus musste festgelegt werden, bis wann die jeweilige Zielgröße erreicht werden soll.

In Umsetzung der vorgenannten Verpflichtung hat der Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec AG am 7. September 2015 für den Frauenanteil im Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec AG eine Zielgröße von 0 Prozent beschlossen. Damit wird der aktuelle Stand festgehalten, so dass sich die Festlegung einer Frist zur Erreichung der vorgenannten Zielgröße erübrigte.

Der Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec AG hat am 7. September 2015 für den Frauenanteil im Vorstand der SÜSS MicroTec AG eine Zielgröße von 0 Prozent beschlossen. Damit wird der aktuelle Stand festgehalten, so dass sich auch insoweit die Festlegung einer Frist zur Erreichung der vorgenannten Zielgröße erübrigte.

Für die erste und zweite Führungsebene unterhalb des Vorstands hat der Vorstand der SÜSS MicroTec AG am 2. September 2015 jeweils eine Zielgröße von 20 Prozent und eine Umsetzungsfrist bis zum 30. Juni 2017 beschlossen. Die Zielgröße für die erste Führungsebene bedeutet eine Steigerung des Frauenanteils, der zum Zeitpunkt der Beschlussfassung bei 18 Prozent lag. Die Zielgröße für die zweite Führungsebene bedeutet ebenso eine Steigerung, da der Frauenanteil zum Zeitpunkt der Beschlussfassung

bei 14 Prozent lag. Die Umsetzungsfrist schöpft den zulässigen Rahmen für die erstmalige Festlegung der Umsetzungsfrist aus. Zum 31. Dezember 2015 liegt der Frauenanteil im Rahmen der ersten Führungsebene weiterhin bei 18 Prozent, der Frauenanteil im Rahmen der zweiten Führungsebene bei 14 Prozent.

Organe

Mitglieder des Vorstands und Aufsichtsrats sowie deren Mandate:

Dr. Per-Ove Hansson

- Dr. rer. nat. (Physik), Feldkirchen, Vorstandsvorsitzender (seit 1. Mai 2015)

WEITERE MANDATE:

- Keine

Michael Knopp

- Diplom-Kaufmann, Ratingen, Finanzvorstand (Vorstandssprecher bis 30. April 2015)

WEITERE MANDATE:

- Keine

Walter Braun

- Diplom-Ingenieur, Altensteig, Produktionsvorstand

WEITERE MANDATE:

- Keine

Dr. Stefan Reineck

- Kirchart, Geschäftsführender Gesellschafter der RMC Dr. Reineck Management & Consulting GmbH, Kirchart; Aufsichtsratsvorsitzender der SÜSS MicroTec AG

WEITERE MANDATE:

- AttoCube Systems AG, München (Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats)
- AWS-Group AG, Heilbronn (Mitglied im Aufsichtsrat)
- Phoseon Technology Inc., Hillsboro, Oregon, USA (Mitglied im „Board of Directors“)
- Wittenstein AG, Igersheim (Mitglied im Aufsichtsrat)
- Accel 4.0 Beteiligungs-GmbH, Heilbronn (Beiratsvorsitzender seit 26. Oktober 2015)

Jan Teichert

- Metten, Mitglied des Vorstands der Einhell Germany AG, Landau, Isar; stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der SÜSS MicroTec AG

WEITERE MANDATE:

- bis 31. Mai 2015 Kolb Technology GmbH, Hengersberg (Mitglied des Beirats)

Gerhard Pegam

- Au bei Bad Aibling, Geschäftsführender Gesellschafter der GPA Consulting; Aufsichtsratsmitglied der SÜSS MicroTec AG

WEITERE MANDATE:

- OC Oerlikon Corporation AG, Pfäffikon, Schweiz (Mitglied des Verwaltungsrats);
- Schaffner Holding AG, Solothurn, Schweiz (Mitglied des Verwaltungsrats)

VERÄNDERUNGEN IM VORSTAND UND AUFSICHTSRAT

Mit Wirkung vom 1. Mai 2015 wurde Dr. Per-Ove Hansson in den Vorstand der SÜSS MicroTec AG berufen. In seiner Funktion als Vorstandsvorsitzender ist er verantwortlich für die einzelnen Produktlinien sowie die Bereiche Vertrieb und Marketing, Service, Forschung und Entwicklung, das Patentwesen und die Konzernstrategie.

BESITZ VON AKTIEN UND BEZUGSRECHTEN

Die im Geschäftsjahr 2015 amtierenden Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats der SÜSS MicroTec AG besitzen zum Geschäftsjahresende am 31. Dezember 2015 folgende Anzahl an Aktien und Bezugsrechten:

Besitz von Aktien und Bezugsrechten

	Anzahl der Aktien zum 31.12.2015	Veränderung gegenüber 31.12.2014	Anzahl der Aktienoptionen zum 31.12.2015	Veränderung gegenüber 31.12.2014
Aufsichtsrat				
Dr. Stefan Reineck	9.600	-	0	-
Jan Teichert	0	-	0	-
Gerhard Pegam	0	-	0	-
Vorstand				
Dr. Per-Ove Hansson	0	-	0	-
Michael Knopp	18.350	-6.650	0	-
Walter Braun	3.150	-7.350	0	-

MELDEPFLICHTIGE AKTIENGESCHÄFTE VON VORSTAND UND AUFSICHTSRAT

Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats sind nach § 15 a Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) gesetzlich verpflichtet, eigene Geschäfte mit Aktien der SÜSS MicroTec AG oder sich darauf beziehenden Finanzinstrumenten offenzulegen, soweit der Wert der von dem Mitglied und ihm nahestehenden Personen innerhalb eines Kalenderjahres getätigten Geschäfte die Summe von 5.000 Euro erreicht oder übersteigt.

Sämtliche Geschäfte des Vorstands und des Aufsichtsrats werden auf der Website des Unternehmens unter ► www.suss.com ► Investor Relations ► Die Aktie ► Directors' Dealings veröffentlicht.

Rechnungslegung und Abschlussprüfung

SÜSS MicroTec erstellt den Konzernabschluss sowie die Zwischenberichte nach den International Financial Reporting Standards (IFRS), wie sie in der Europäischen Union für börsennotierte Gesellschaften anzuwenden sind. Der Einzelabschluss der SÜSS MicroTec AG wird nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) erstellt.

Am 2. Juni 2015 bestellte die Hauptversammlung die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Sitz in Hamburg, Zweigniederlassung München, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer der SÜSS MicroTec AG für das Geschäftsjahr 2015. Damit werden Jahresabschluss und Konzernabschluss der SÜSS MicroTec AG zum vierten Mal in Folge von einem Unternehmen der BDO-Gruppe geprüft. Die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat 2015 neben der Prüfungstätigkeit keinerlei Beratungsleistungen für SÜSS MicroTec erbracht. Als Nachweis seiner Unabhängigkeit hat der Abschlussprüfer gegenüber dem Aufsichtsrat eine Unabhängigkeitserklärung abgegeben. Des Weiteren wurde mit dem Abschlussprüfer vereinbart,

dass dieser den Aufsichtsrat über alle wesentlichen Feststellungen und Vorkommnisse informiert, die sich bei der Durchführung der Abschlussprüfung ergeben. Leitender Prüfer für das Geschäftsjahr 2015 war Wirtschaftsprüfer Thomas Steiner, der die Abschlussprüfung und Konzernabschlussprüfung der SÜSS MicroTec AG zum zweiten Mal als leitender Prüfer betreute.

Erklärung zur Unternehmensführung

Die Erklärung zur Unternehmensführung nach § 289 a HGB ist Bestandteil des Lageberichts und wird auf der Internetseite der Gesellschaft unter ► www.suss.com ► Investor Relations ► Corporate Governance ► Erklärung zur Unternehmensführung allgemein zugänglich gemacht und ist zudem im zusammengefassten Lagebericht vollständig abgedruckt.

Vergütungsbericht

Die Grundzüge des Vergütungssystems haben wir im Vergütungsbericht dargestellt, der im zusammengefassten Lagebericht abgedruckt ist.

Zusammengefasster Lagebericht

der SÜSS MicroTec AG für das Geschäftsjahr 2015

Wirtschaftsbericht	34
-----	-----
Geschäftstätigkeit, Unternehmenssteuerung und strategische Ausrichtung	34
Wirtschaftliches Umfeld	37
SÜSS MicroTec in Zahlen	38
Ertragslage: Auftragseingang, Umsatz und EBIT	38
Entwicklung in den einzelnen Segmenten	40
Entwicklung in den wichtigsten Regionen	42
Finanz- und Vermögenslage	43
Investitionen	45
Forschung und Entwicklung	46
Die Holding – SÜSS MicroTec AG	49
Wesentliche Veränderungen der Vermögens- und Finanzlage	49
Wesentliche Ereignisse mit Einfluss auf die Ertragslage der Holding	50
Nachhaltigkeit	51
Compliance	51
Qualitätsmanagement	51
Umweltverantwortung	51
Mitarbeiter	53
Kundenbeziehungen	54

*Blick in die
ACS300 Gen2*

Übernahmerechtliche Angaben gemäß § 289 Abs. 4 HGB und § 315 Abs. 4 HGB	55
Erklärung zur Unternehmensführung gemäß § 289a HGB	57
Vergütungsbericht	61
Vergütung des Vorstands	61
Vergütung des Aufsichtsrats	66
Nachtragsbericht	67
Potenziale	67
Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung des SÜSS MicroTec-Konzerns	67
Chancen des Konzerns	67
Risikomanagement-System	71
Risiken des Konzerns	73
Gesamteinschätzung	78
Prognosebericht	79

Wirtschaftsbericht

Geschäftstätigkeit, Unternehmenssteuerung und strategische Ausrichtung

Der SÜSS MicroTec-Konzern entwickelt, fertigt und vertreibt Anlagen für die Herstellung von Mikroelektronik und Mikrosystemtechnik. Als Zulieferer von Systemlösungen für die Halbleitertechnik ist die Gruppe als leistungsstarker Partner der Halbleiter-Industrie für den Labor- und den Produktionsbereich tätig. Wachstumsstarke Spezialmärkte bilden die Tätigkeitsschwerpunkte und fördern die innovative Technologieentwicklung mit langfristigem Erfolgspotenzial für zukunftsorientierte Märkte und Anwendungen. Im Mittelpunkt steht die Aufbau- und Verbindungstechnik von Mikrochips bei Anwendungen in der Chipfertigung, der Telekommunikation und der optischen Datenübertragung. Größere Prozesslinien bestehen in der Regel aus mehreren Einzelgeräten, wobei die Gruppe mit internen und externen Partnern Netzwerke zur Schaffung von Wettbewerbsvorteilen bildet und nutzt.

Der Konzern ist zum 31. Dezember 2015 in vier Segmente eingeteilt, wobei das Segment „Sonstige“ aus mehreren kleineren Teileinheiten besteht, die jeweils getrennt geleitet werden. Durch die Akquisition der HamaTech APE GmbH & Co. KG (nach Umfirmierung: SÜSS MicroTec Photomask Equipment GmbH & Co. KG) wurde im Geschäftsjahr 2010 ein neues Segment – Fotomasken Equipment – geschaffen. Die im März 2012 akquirierte Tamarack Scientific Co., Inc. (nach Umfirmierung: SÜSS MicroTec Photonic Systems Inc.) ist im Segment Lithografie angesiedelt.

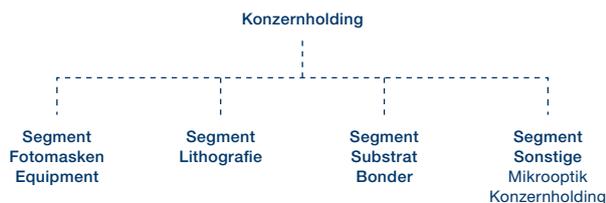
RECHTLICHE KONZERNSTRUKTUR

Die rechtliche Konzernstruktur besteht aus der Muttergesellschaft, der SÜSS MicroTec AG als Management- und Finanzierungsholding, sowie den mehrheitlich im Eigentum der Muttergesellschaft stehenden Tochtergesellschaften. In den Tochtergesellschaften sind jeweils Entwicklungs- und Produktionstätigkeiten oder auch lokale Vertriebs- und Servicetätigkeiten für den Konzern organisiert. Die Gruppe verfügt über Standorte in Deutschland, den USA, Großbritannien, Frankreich, der Schweiz, Japan, China, Singapur, Korea und Taiwan. Die geringfügige Beteiligung von 10 % an der ELECTRON-MEC S.R.L., Mailand (IT) wurde im Geschäftsjahr 2014 verkauft, da sie nur eine unwesentliche Bedeutung für das operative Geschäft hatte.

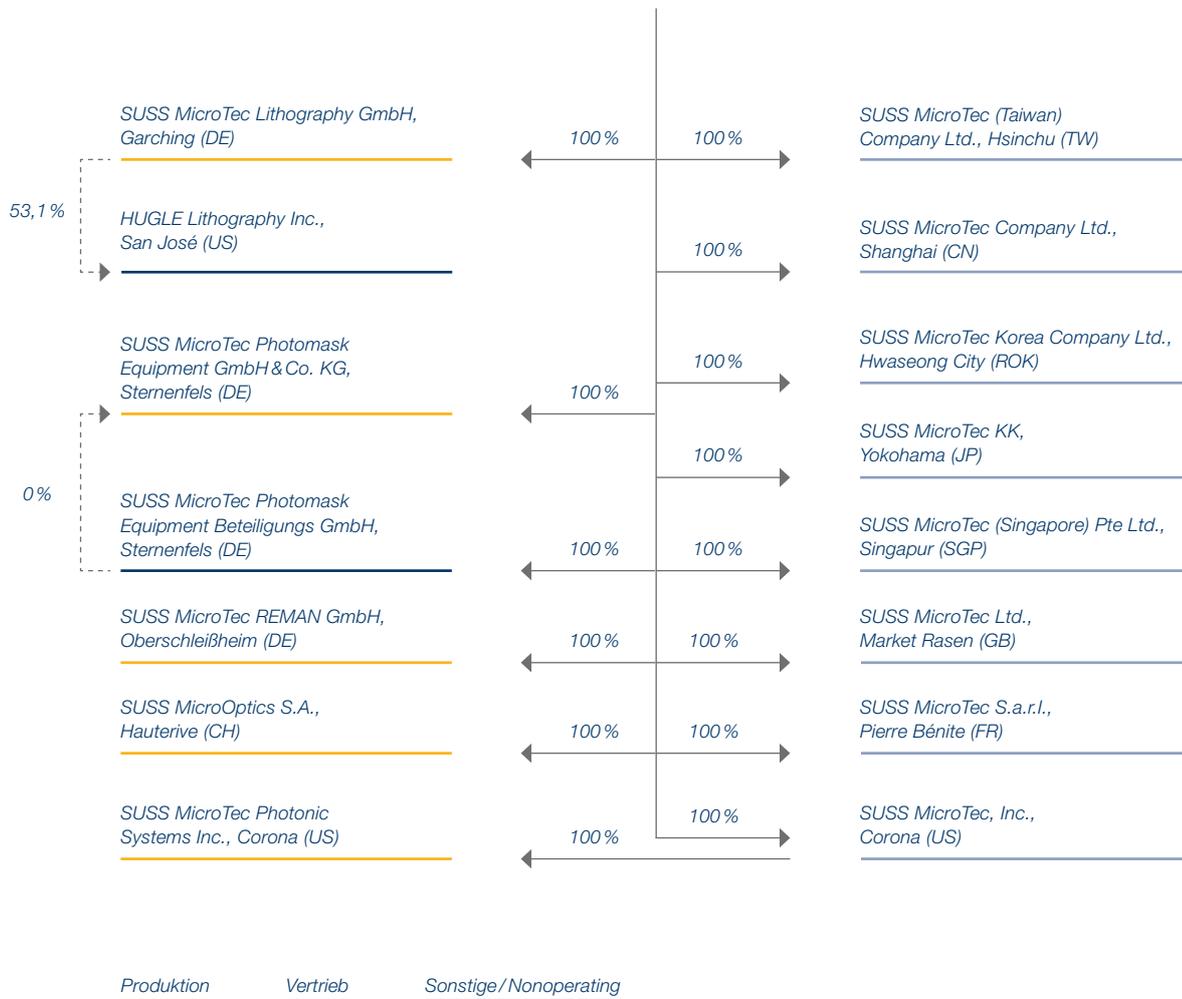
LEITUNG UND KONTROLLE – VERGÜTUNGSSTRUKTUR FÜR DIE ORGANMITGLIEDER

Der Vorstand erhält für seine Tätigkeit eine monatliche Festvergütung sowie eine variable Vergütung, die bei Erreichen individuell festgelegter Ziele gezahlt wird. In den Festbezügen enthalten sind Nebenleistungen in Form eines Dienstwagens mit privater Nutzungsmöglichkeit und Zuschüsse zur Krankenversicherung sowie zur freiwilligen Rentenversicherung. Die Höhe der Festbezüge wird in erster Linie von der übertragenen Funktion bzw. Verantwortung bestimmt. Einzelnen Mitgliedern des Vorstands sind zusätzlich Versorgungszusagen in Form von Direktversicherungen gemacht worden. Die variable Vergütung enthält kurzfristige und auch langfristige Komponenten, nähere Hinweise hierzu sind im Vergütungsbericht zu finden.

Segmentstruktur



SÜSS MICROTEC AG, GARCHING (DE)



Die Vergütung des Aufsichtsrats ist in § 19 der Satzung der SÜSS MicroTec AG geregelt. Gemäß § 19 der Satzung erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrats folgende Vergütung: Neben der Erstattung ihrer Auslagen und einem Sitzungsgeld von 2.000 € pro Sitzung erhält jedes Aufsichtsratsmitglied eine feste Vergütung, die sich an der Verantwortung und dem Tätigkeitsumfang der Aufsichtsratsmitglieder orientiert. Demnach erhält der Vorsitzende des Aufsichtsrats 60.000 €, sein Stellvertreter 50.000 € und ein einfaches Mitglied des Aufsichtsrats 45.000 € pro Geschäftsjahr als feste Vergütung.

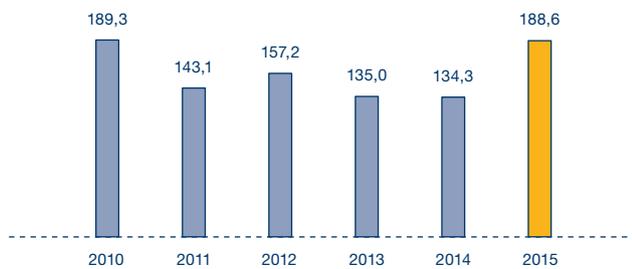
UNTERNEHMENSSTEUERUNG, ZIELE UND UNTERNEHMENSSTRATEGIE

SÜSS MicroTec verfolgt die Besetzung lukrativer Spezialmärkte in der Industrie der Halbleiterausrufter als Strategie. Ziel ist es, durch eine klare Positionierung stets innerhalb der Top-3-Anbieter in den relevanten Märkten zu agieren. Partnerschaften mit führenden Instituten und Unternehmen der Industrie sollen sicherstellen, dass wesentliche Trends oder zukunftssträchtige Technologien stets rechtzeitig erkannt und auf deren Potenziale

für SÜSS MicroTec überprüft werden. Im Vordergrund steht dabei organisches Wachstum; im Falle interessanter Technologien oder sinnvoller Komplementärprodukte wird auch externes Wachstum in Betracht gezogen.

Die Unternehmenssteuerung orientiert sich insbesondere am Auftragseingang, Umsatz und Auftragsbestand der einzelnen Segmente. Die Leistungsfähigkeit der Segmente wird dabei vor allem durch Beobachtung der Entwicklung der Rohertragsmarge (Umsatz abzüglich der Herstellungskosten) sowie des Segmentergebnisses gemessen. Die Darstellung des Segmentergebnisses enthält auch Erträge und Aufwendungen aus der Fremdwährungsumrechnung und aus Anlagenabgängen. In der Summe entsprechen die Ergebnisse der Segmente dem operativen Ergebnis (EBIT) des Konzerns. Weitere Steuerungskennzahl ist die Nettoliquidität (flüssige Mittel zuzüglich verzinslicher Wertpapiere und abzüglich Finanzschulden), die eine wesentliche Steuerungsgröße für die Finanzierungsfunktion der Holding darstellt. In der folgenden Darstellung sehen Sie die Entwicklung wichtiger Kennzahlen seit 2010.

Auftragseingang in Mio. €



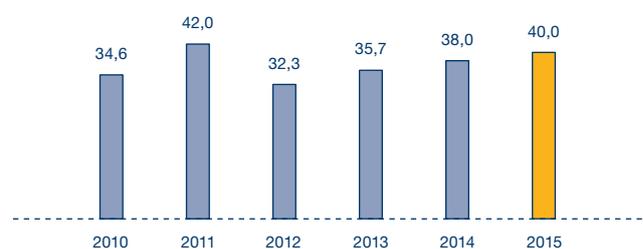
Umsatz in Mio. € und **Bruttomarge**



EBIT in Mio. € und **EBIT-Marge**



Nettoliquidität in Mio. €



¹ EBIT 2013 enthält Einmalkosten für die Refokussierung der Produktlinie permanente Bonder in Höhe von 13,2 Mio. €

Wirtschaftliches Umfeld

POLITISCHE UND HUMANITÄRE KRISEN PRÄGEN DAS WIRTSCHAFTSBILD IN EUROPA

In ihren aktuellsten Schätzungen erwartet die OECD ein leicht verlangsamtes globales Wirtschaftswachstum von rund 3,0 % für 2015, nach 3,3 % im Vorjahr. Die allgemein niedrigen Rohstoffpreise sowie insbesondere der geringe Ölpreis dämpften das Wachstum in den Schwellenländern. In den fortgeschrittenen Ländern hat sich der moderate Aufschwung erwartungsgemäß fortgesetzt.

Nachdem im Sommer 2015 die Schuldenkrise in Griechenland vorerst durch ein weiteres Hilfspaket entspannt wurde, hat die politische Situation in zahlreichen Krisengebieten, wie beispielsweise in Syrien, der Türkei oder der Ukraine, negativ auf die gesamtwirtschaftliche Stimmung in Europa gewirkt. Die anhaltende Flüchtlingswelle sowie die Zunahme terroristischer Bedrohungen stellen viele europäische Staaten vor bisher ungekannte wirtschaftliche, politische und humanitäre Herausforderungen. Die Eurozone erreichte 2015 dennoch ein Wachstum von 1,5 %, für die Europäische Union insgesamt geht man im gleichen Zeitraum von einem leicht höheren Plus in Höhe von 1,9 % aus (Quelle: Europäische Kommission, November 2015 und OECD, Februar 2016). Getragen wurde das Wachstum durch starke Exporte, die dem vergleichsweise schwachen Euro geschuldet sind sowie dem niedrigen Ölpreis und den dadurch gestiegenen zur Verfügung stehenden Einkommen.

Die deutsche Wirtschaft wurde im Geschäftsjahr 2015 überwiegend durch die lebhaftere Binnennachfrage getragen. Vorteilhaft haben sich hierbei die günstige Arbeitsmarktlage sowie die zum Teil kräftigen Zuwächse der verfügbaren Einkommen ausgewirkt. Gemäß den Schätzungen der OECD vom Februar 2016 betrug das Wirtschaftswachstum in Deutschland im Jahr 2015 rund 1,4 %.

2015 WAR EIN SCHWIERIGES JAHR FÜR DEN HALBLEITER-MARKT

Im Geschäftsjahr 2015 lag das Marktvolumen des gesamten Halbleiter-Marktes bei 333,7 Mrd. USD nach 340,3 Mrd. USD im Vorjahr, dies bedeutet einen Rückgang um rund 1,9 % (Quelle: Gartner, Januar 2016) und damit den ersten Rückgang in der Halbleiter-Industrie seit 2012. Der starke US-Dollar sowie das allgemein abgeschwächte Wachstum bei Elektronikprodukten wie Smartphones, Tablets und PCs haben den Markt im abgelaufenen Geschäftsjahr belastet. Zudem sei die Nachfrage nach DRAM-Speichermedien rückläufig gewesen, schreibt Gartner.

Umsatzentwicklung im Halbleiter-Markt in Mrd. USD



Quelle: Gartner, 2011–2016

ENTWICKLUNG IM SEGMENT HALBLEITER-EQUIPMENT

Der Markt für Halbleiter-Equipment ist nach aktuellen Schätzungen des Branchenverbands Semi im Jahr 2015 um rund 0,6% geschrumpft. Die Gründe hierfür liegen – wie auch für die gesamte Halbleiter-Industrie – im Wesentlichen in den rückläufigen Wachstumsraten für Smartphones, Tablets und PCs. Der ansonsten branchentypische Anstieg der Verkaufszahlen vor der Urlaubssaison sei dieses Jahr ausgeblieben und führte am Ende zu einem schrumpfenden Gesamtmarkt.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden die Investitionen im Wesentlichen für Maschinen zur Bearbeitung von Wafergrößen von 300mm getätigt, nur rund 10% des Investments gingen in Maschinen für die Bearbeitung von 200mm Wafern oder noch kleineren Wafergrößen. Nach Aussage des Branchenverbands Semi wurde dabei überwiegend in Maschinen für die Herstellung von Speicherchips, insbesondere für DRAMs mit einer Strukturgröße von 21/20nm, investiert.

SÜSS MicroTec in Zahlen

ERTRAGSLAGE:

AUFTRAGSEINGANG, UMSATZ UND EBIT

Vergleich Gesamtjahreszahlen 2015 – Prognose 2015

Im Prognosebericht des Lageberichts 2014 hat das Unternehmen für das Geschäftsjahr 2015 einen Umsatz von 130 bis 140 Mio. € sowie ein ausgeglichenes Ergebnis (EBIT) in Aussicht gestellt. Im August 2015 wurden die Umsatz- und Ergebnisprognosen für das laufende Geschäftsjahr angehoben. SÜSS MicroTec schloss das Geschäftsjahr 2015 mit einem Umsatz in Höhe von 148,5 Mio. € ab. Das EBIT erreichte einen Wert von 5,0 Mio. €. Damit lag das Unternehmen im Umsatz und Ergebnis leicht über der eigenen Erwartung.

	Prognose 2015	Angepasste Prognose 2015	Ergebnis 2015
Umsatz	130–140 Mio. €	135–145 Mio. €	148,5 Mio. €
EBIT	ausgeglichen	leicht positiv	5,0 Mio. €
EBIT-Marge	–	1%–2%	3,4%

Unternehmensentwicklung im Jahr 2015

Der Auftragseingang belief sich im Geschäftsjahr 2015 auf insgesamt 188,6 Mio. €, während im Vorjahr ein Auftragseingang von 134,3 Mio. € erzielt wurde. Insbesondere das vierte Quartal 2015, in dem ein Rekord-Auftragseingang von 79,7 Mio. € verbucht wurde, hatte großen Anteil daran. Damit lagen die Auftragseingänge 2015 rund 40,4% über den Auftragseingängen des Vorjahres. Zum 31. Dezember 2015 ergab sich ein Auftragsbestand von 117,6 Mio. €, der damit um rund 42,0 Mio. € über dem Auftragsbestand des Vorjahres (75,6 Mio. €) lag. Das Verhältnis von neu eingegangenen Aufträgen zu realisierten Umsätzen (Book-to-Bill-Ratio) lag bei 1,27 nach 0,92 im Vorjahr.

Umsatzentwicklung im Wafer Fab Equipment in Mrd. USD



Quelle: Gartner, 2011–2016

Die Ertragslage des SÜSS MicroTec-Konzerns zeigt im Geschäftsjahr 2015 einen Umsatzanstieg und ein positives Jahresergebnis. Die Umsatzerlöse erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 2,2 % und beliefen sich auf 148,5 Mio. €, während im Vorjahr Umsätze von 145,3 Mio. € erzielt wurden. Das EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) belief sich 2015 auf 5,0 Mio. €. 2014 wurde ein EBIT von 8,4 Mio. € erreicht.

Im umsatzstärksten Segment von SÜSS MicroTec, der Lithografie, wurde ein Umsatzplus von 9,6 Mio. € erzielt. Der Anteil der Umsätze des Segments Lithografie betrug 2015 knapp 72 % der gesamten Konzernumsätze. Im Segment Substrat Bonder war hingegen ein Umsatzrückgang um rund 11,0 Mio. € zu verzeichnen. Im Segment Fotomasken Equipment ergaben sich Umsatzzuwächse von 2,7 Mio. €, während im Segment Sonstiges ein Umsatzanstieg von 1,9 Mio. € verbucht werden konnte.

In den Umsatzkosten sind Abschreibungen auf aktivierte Entwicklungskosten in Höhe von 0,1 Mio. € enthalten. Die Neu-Aktivierungen beliefen sich auf 1 Tsd. €. Sowohl die Abschreibungen als auch die Neuaktivierungen auf Entwicklungskosten betreffen ausschließlich das Segment Lithografie. Im Vorjahr wurden Abschreibungen auf aktivierte Entwicklungskosten von 0,5 Mio. € erfasst. Die Neu-Aktivierungen summierten sich im Vorjahr auf 45 Tsd. €.

Im Geschäftsjahr 2015 wurde ein Rohertrag von 49,4 Mio. € erzielt, was einer Rohertragsmarge von 33,3 % entspricht. Im Vorjahr betrug der Rohertrag 48,8 Mio. €; die Rohertragsmarge 2014 belief sich auf 33,6 %.

Die Vertriebskosten des Geschäftsjahres haben sich erhöht und lagen bei 18,8 Mio. € (Vorjahr: 17,5 Mio. €), was – in Relation zum erzielten Umsatz – einer Aufwandsquote von 12,7 % (Vorjahr: 12,1 %) entspricht.

Die Verwaltungskosten reduzierten sich von 14,2 Mio. € im Vorjahr auf nun 13,3 Mio. € und entsprechen damit einer Aufwandsquote von 8,9 % (Vorjahr: 9,8 %). Im Vorjahr war in den Verwaltungskosten eine Abfindung für ein ausgeschiedenes Vorstandsmitglied enthalten, die sich auf 1,1 Mio. € belief.

Die Forschungs- und Entwicklungskosten erhöhten sich von 10,5 Mio. € im Vorjahr auf 12,8 Mio. €. Im Jahr 2015 hat SÜSS MicroTec – wie geplant – seine Aktivitäten im Bereich Forschung und Entwicklung deutlich ausgebaut und Mitarbeiter eingestellt.

Die sonstigen betrieblichen Erträge beliefen sich im Geschäftsjahr auf 4,9 Mio. € (Vorjahr: 4,5 Mio. €). Sie beinhalten – wie auch im Vorjahr – hohe Fremdwährungsgewinne, die sich aus der Umrechnung von Fremdwährungsposten in Euro ergeben

haben. Im Jahr 2015 konnten durch eine Stornovereinbarung mit einem Kunden Erträge von 0,6 Mio. € erzielt werden. Im Vorjahr wurden Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen von 1,3 Mio. € realisiert.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beliefen sich 2015 auf 4,4 Mio. € (Vorjahr: 2,7 Mio. €) und beinhalten vor allem Aufwendungen aus Fremdwährungsumrechnungen.

Das EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) belief sich im abgelaufenen Geschäftsjahr auf 5,0 Mio. €. 2014 wurde ein EBIT von 8,4 Mio. € erzielt.

Das Finanzergebnis belief sich 2015 auf -0,3 Mio. € (nach -0,2 Mio. € im Vorjahr).

Das Konzernergebnis vor Steuern von 4,7 Mio. € ist mit einem Steueraufwand von 4,5 Mio. € belegt, was einer durchschnittlichen Steueraufwandsquote von rund 95 % entspricht. Grund für den – in Relation zum Gewinn vor Steuern – außerordentlich hohen Steueraufwand sind vor allem im Geschäftsjahr 2015 aufgelaufene Verluste ausländischer Konzerngesellschaften (insbesondere in den USA), für die unter Berücksichtigung der aktuellen Konzernplanung (analog zu den Vorjahren) keine aktiven latenten Steuern angesetzt wurden. Dadurch wird für die in den ausländischen Gesellschaften entstandenen Verluste kein entsprechender Steuerertrag berücksichtigt.

Im Vorjahr war das Konzernergebnis vor Steuern von 8,2 Mio. € mit einem Steueraufwand von 3,6 Mio. € belegt, was einer durchschnittlichen Steueraufwandsquote von rund 44 % entspricht. Somit wick auch im Vorjahr die tatsächliche Steueraufwandsquote deutlich von der erwarteten Steueraufwandsquote ab. Grund für den – in Relation zum Gewinn vor Steuern – hohen Steueraufwand waren ebenfalls im Geschäftsjahr 2014 aufgelaufene Verluste ausländischer Konzerngesellschaften (insbesondere in den USA), für die keine aktiven latenten Steuern angesetzt wurden.

Im Konzern ergab sich ein Gewinn nach Steuern von 0,2 Mio. € (Vorjahr: 4,6 Mio. €). Das unverwässerte Ergebnis je Aktie betrug 0,01 € nach 0,24 € im Vorjahr.

Der Umsatz je Mitarbeiter reduzierte sich im Vergleich zum Vorjahr um 3,6 % von 221 Tsd. € auf 213 Tsd. € (basierend auf der jeweiligen Anzahl der Mitarbeiter zum Bilanzstichtag).

ENTWICKLUNG IN DEN EINZELNEN SEGMENTEN

Lithografie

Das Segment Lithografie umfasst die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb der Produktlinien Mask Aligner, UV-Projektionsscanner, Laser Processing Tools sowie Belacker und Entwickler. Die Fertigung dieser Produktlinien ist in Deutschland an den Standorten Garching bei München und seit Anfang 2010 in Sternenfels angesiedelt. Die Lithografiesparte wurde im ersten Quartal 2012 mit der Akquisition der Tamarack Scientific Co., Inc. (firmiert heute unter SÜSS MicroTec Photonic Systems Inc.) verstärkt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Corona, Südkalifornien, USA. Das Segment Lithografie ist mit einem Umsatzanteil von mehr als 70 % der größte Bereich der SÜSS MicroTec-Gruppe. Die Komponenten, die auf diesen Maschinen gefertigt werden, gehen im Wesentlichen in die Endmärkte Advanced Packaging, Mikrosystemtechnik und Verbindungshalbleiter (LED) sowie 3D-Integration.

Im Geschäftsjahr 2015 erzielte das Segment Lithografie einen Auftragseingang von 149,6 Mio. € sowie einen Umsatz von 106,3 Mio. €. Dies entspricht einem Plus im Auftragseingang von 63,5 % sowie einem Plus im Umsatz von 9,9 % gegenüber dem Vorjahr. Der deutliche Anstieg im Auftragseingang wurde über alle Produktlinien erzielt. Bei den 300 mm Belackern und Entwicklern konnten Marktanteile zurückgewonnen und ausgebaut werden. Mit unseren neuartigen UV-Projektionsscannern ist es uns 2015 erstmals gelungen, einen Großauftrag für die Serienfertigung bei einem wichtigen Halbleiterhersteller zu gewinnen. Daneben war die Produktlinie Mask Aligner besonders bei MEMS-Kunden in Europa und den USA sehr erfolgreich.

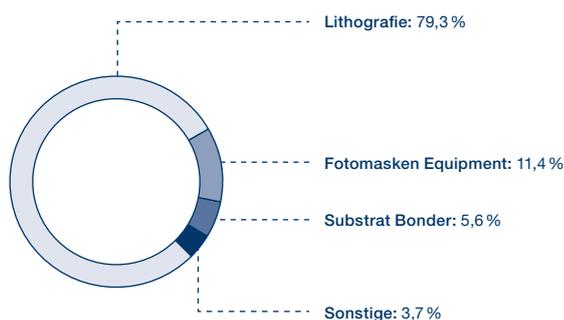
Der Rohertrag im Segment Lithografie lag im abgelaufenen Geschäftsjahr leicht unter dem Vorjahreswert. Die Rohertragsmarge lag 2015 bei 34,2 % nach 35,7 % im Vorjahr.

Das Segment Lithografie steuerte ein Segmentergebnis in Höhe von 9,7 Mio. € (Vorjahr: 10,7 Mio. €) zum Konzern-EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) bei. Damit ergibt sich für das Segment Lithografie eine Umsatzrendite von 9,1 %, die sich im Vergleich zum Vorjahr leicht verringert hat (Umsatzrendite des Vorjahres: 11,0 %). Wie bereits in früheren Berichten geschildert, hat sich die Wettbewerbssituation bei den Belackern und Entwicklern in den vergangenen Jahren deutlich verstärkt und zu einer spürbaren Verringerung der erzielbaren Margen geführt. Die Margen in der Produktlinie Mask Aligner blieben dagegen stabil.

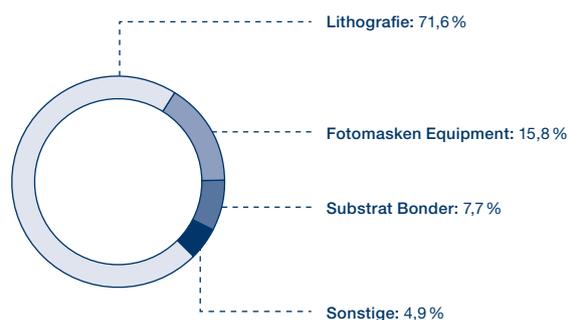
Kennzahlen Lithografie

in Mio. €	2015	2014
Auftragseingang	149,6	91,5
Segmentumsatz	106,3	96,7
Segmentergebnis EBIT	9,7	10,7
Nettovermögen	51,3	50,3

Auftragseingang nach Segmenten



Umsatz nach Segmenten



Substrat Bonder

Das Segment Substrat Bonder umfasst die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb der Substrat (Wafer) Bonder. Die Fertigung ist an unserem größten Standort in Sternenfels angesiedelt. Zu den adressierten Märkten der Substrat Bonder zählen die Mikrosystemtechnik, die Verbindungshalbleiter sowie die 3D-Integration.

Das Segment Substrat Bonder entwickelte sich sowohl im Auftragseingang mit 10,5 Mio. € (Vorjahr: 17,2 Mio. €) als auch im Umsatz mit 11,4 Mio. € (Vorjahr: 22,4 Mio. €) erneut rückläufig. Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden gegenüber 2014 deutlich weniger Aufträge erzielt, der Hauptgrund hierfür liegt in der Refokussierung der Produktlinie permanente Bonder. Wurden in diesem Bereich 2014 noch Aufträge für permanente Produktionsbonder im einstelligen Millionen-Euro-Bereich verbucht, so lag der Anteil am Auftragseingang im Jahr 2015 nahezu bei null. Eine ähnliche Situation ergibt die Analyse der Umsatzentwicklung: Auch hier wurden 2015 deutlich weniger Umsätze mit permanenten Produktionsbondern als noch im Vorjahr realisiert. Für die Zukunft erwarten wir in diesem Bereich wieder deutlich steigende Auftragseingänge und Umsätze, insbesondere durch die Einführung neuer Produkte sowie die Rückgewinnung von Marktanteilen bei der MEMS- und LED-Herstellung.

Das Rohergebnis des Segments Substrat Bonder war im abgelaufenen Geschäftsjahr positiv. Die Rohertragsmarge verbesserte sich erneut von 13,9% auf 19,3%. Die seit dem Geschäftsjahr 2014 erzielten Margen im Bereich Temporary Bonding und Debonding sowie das verbleibende Geschäft mit permanenten Bond-Systemen haben sich nachhaltig verbessert, sind jedoch aufgrund der insgesamt niedrigen Stückzahlen weiterhin unterdurchschnittlich. Im Segment Substrat Bonder ergibt sich ein Segmentergebnis (EBIT) von -4,0 Mio. € nach -2,4 Mio. € im Vorjahr.

Kennzahlen Substrat Bonder

in Mio. €	2015	2014
Auftragseingang	10,5	17,2
Segmentumsatz	11,4	22,4
Segmentergebnis EBIT	-4,0	-2,4
Nettovermögen	5,7	7,8

Fotomasken Equipment

Das Segment Fotomasken Equipment umfasst die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von Maschinen, die auf die Reinigung und Prozessierung von Fotomasken für die Halbleiter-Industrie spezialisiert sind, und ist am Standort Sternenfels bei Stuttgart angesiedelt. Zu den adressierten Märkten des Segments Fotomasken Equipment zählt die Halbleiter-Industrie, hier ist SÜSS MicroTec überwiegend im Frontend tätig.

Das Segment Fotomasken Equipment entwickelte sich im abgelaufenen Geschäftsjahr sowohl im Auftragseingang als auch im Umsatz besser als im Vorjahr. Der Auftragseingang lag Ende Dezember 2015 bei 21,5 Mio. € (Vorjahr: 20,2 Mio. €). Der Segmentumsatz belief sich auf 23,5 Mio. € nach 20,8 Mio. € im Jahr 2014.

Aufgrund einiger margenstarker Aufträge lag die Rohertragsmarge im Geschäftsjahr 2014 bei 40,3%. Im Geschäftsjahr 2015 konnte ein Wert von 31,5% erreicht werden.

Das Segment Fotomasken Equipment trug mit einem Segmentergebnis von 2,3 Mio. € (Vorjahr: 4,7 Mio. €) zum Konzern-EBIT bei. Die Umsatzrendite lag bei 9,9% und hat sich damit im Vergleich zum sehr starken Vorjahr (Umsatzrendite 2014: 22,7%) deutlich verringert. Die Gründe für die außergewöhnlich hohe Umsatzrendite 2014 waren im Wesentlichen einige margenstarke Aufträge.

Kennzahlen Fotomasken Equipment

in Mio. €	2015	2014
Auftragseingang	21,5	20,2
Segmentumsatz	23,5	20,8
Segmentergebnis EBIT	2,3	4,7
Nettovermögen	6,8	3,7

Sonstige

Das Segment Sonstige umfasst die Mikrooptik-Aktivitäten am Standort Hauterive, Schweiz, sowie die größtenteils auf Segmentebene nicht zurechenbaren Kosten der zentralen Konzernfunktionen.

Der Auftragseingang steigerte sich deutlich von 5,4 Mio. € im Geschäftsjahr 2014 auf 7,0 Mio. € im Jahr 2015. Der Segmentumsatz belief sich auf 7,3 Mio. € nach 5,4 Mio. € im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Größten Anteil am Umsatz und Auftragseingang hatte dabei – wie auch im Vorjahr – das Geschäftsfeld Mikrooptik, das einen erhöhten Auftragseingang von 6,6 Mio. € (Vorjahr: 5,1 Mio. €) sowie im Umsatz einen Anstieg von 5,1 Mio. € auf 6,8 Mio. € erzielte.

Kennzahlen Sonstige

in Mio. €	2015	2014
Auftragseingang	7,0	5,4
Segmentumsatz	7,3	5,4
Segmentergebnis EBIT	-3,1	-4,5
Nettovermögen	19,9	19,3

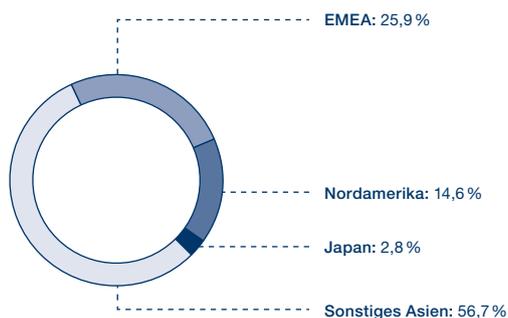
ENTWICKLUNG IN DEN WICHTIGSTEN REGIONEN

Europa, Nordamerika und Asien sind die für das Geschäft von SÜSS MicroTec wichtigen Weltregionen. Dabei unterteilen wir Asien jedoch in Japan und „Sonstiges Asien“, um dem Umstand Rechnung zu tragen, dass unsere Kunden im Markt Advanced Packaging vornehmlich außerhalb Japans – insbesondere in Taiwan – ansässig sind. Dieser Markt ist allerdings auch schwankungsanfälliger als jener für Verbindungshalbleiter und MEMS.

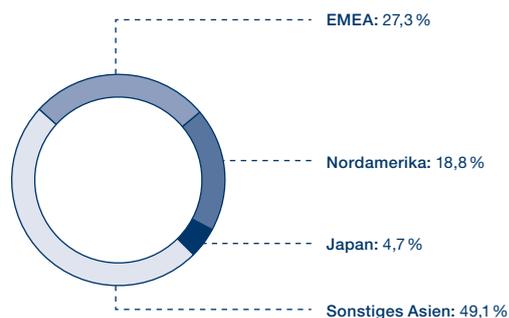
In allen Regionen bis auf Japan konnten im vergangenen Geschäftsjahr deutliche Zuwächse im Auftragseingang erwirtschaftet werden. Nordamerika steigerte seinen Auftragseingang von 21,9 Mio. € im Jahr 2014 auf 27,6 Mio. € im Geschäftsjahr 2015. Dieser Zuwachs um 26,0% entstammt im Wesentlichen der guten Positionierung bei führenden MEMS-Kunden in den USA. In der wichtigsten Region „Sonstiges Asien“ (ohne Japan) verzeichnete die SÜSS MicroTec-Gruppe ein enormes Auftragsplus in Höhe von 70,7% auf 107,0 Mio. € (Vorjahr: 62,7 Mio. €). Die Gründe hierfür liegen in einem generellen Anstieg der Nachfrage nach unseren Lithografieprodukten, insbesondere aus der Region Taiwan sowie der Region Asien and Pazifik. Dazu gehören unter anderem die 300 mm Belacker- und Entwickler-Systeme sowie UV-Projektionsscanner. Auch Europe Middle East and Africa (EMEA) konnte gegenüber Vorjahr deutlich zulegen und erreichte einen Auftragseingang von 48,8 Mio. €, ein zweistelliges Plus gegenüber Vorjahr von 19,0%. Lediglich Japan verringerte seinen Auftragseingang im Vergleich zum Vorjahr um 40,2% und erreichte damit einen Auftragseingang von lediglich 5,2 Mio. €.

Beim Umsatz zeigt sich regional ein sehr unterschiedliches Bild. Während in Nordamerika deutliche Zuwächse verbucht werden konnten, haben die Regionen EMEA und Japan gegenüber Vorjahr geringere Umsätze erwirtschaftet. EMEA verzeichnete einen Rückgang um 5,2% auf 40,5 Mio. € während der Rückgang in Japan mit -30,7% deutlicher ausfiel. Nordamerika konnte durch die erhöhte Umsatzlegung im Bereich Fotomaschinen Equipment einen Umsatzzuwachs um 30,2% auf 28,0 Mio. € erreichen. Die größte Region – „Sonstiges Asien“ – verbuchte ein leichtes Umsatzplus von 2,9% auf 73,0 Mio. €.

Auftragseingang nach Regionen



Umsatz nach Regionen



FINANZ- UND VERMÖGENSLAGE

Eine stabile Finanz- und Vermögenslage zeichnet SÜSS MicroTec aus

Die Net Cash-Position des Konzerns – der Saldo aus flüssigen Mitteln sowie verzinslichen Wertpapieren und Finanzverbindlichkeiten – erhöhte sich von 38,0 Mio. € im Vorjahr auf 40,0 Mio. € zum 31. Dezember 2015. Der Bestand an liquiden Mitteln und verzinslichen Wertpapieren erhöhte sich von 48,3 Mio. € im Vorjahr auf 49,1 Mio. € zum Ende des Berichtsjahres.

Der Cashflow aus dem operativen Geschäft belief sich auf 4,7 Mio. € (Vorjahr: 5,1 Mio. €). Zum 31. Dezember 2015 wies SÜSS MicroTec hohe Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen aus, die sich mit rund 4,7 Mio. € positiv auf den operativen Cashflow auswirkten. Auch die hohen Steuerverbindlichkeiten in Deutschland sowie der konzernweit geringe Bestand an Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wirkten mit insgesamt 5,0 Mio. € liquiditätserhöhend. Dagegen machte sich der zum Jahresende hohe Bestand an Vorräten mit 8,1 Mio. € liquiditätsmindernd bemerkbar. Der Anstieg des Vorratsvermögens im Vergleich zum Vorjahr entfiel vor allem auf verstärkte Zukäufe von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen, die dem am Jahresende hohen Auftragsbestand geschuldet sind.

Der Cashflow aus der Investitionstätigkeit betrug ohne Berücksichtigung der Investitionen in Wertpapiere -3,4 Mio. € (Vorjahr: -3,0 Mio. €). Die Investitionen in Sachanlagen betrafen teilweise weitere Einbauten in die gemieteten Räume der SÜSS MicroOptics (Hauterive, Schweiz), für die Mittelabflüsse von rund 0,5 Mio. € zu verzeichnen waren. In den Gebäuden an den Produktionsstandorten Garching und Sternenfels wurden Erneuerungen und Einbauten vorgenommen. Darüber hinaus wurden vor allem Neuanschaffungen in technische Anlagen und Maschinen sowie in Betriebs- und Geschäftsausstattung der deutschen Gesellschaften getätigt. Die Investitionen in immaterielle

Vermögenswerte betrafen vorwiegend Erweiterungen des konzernweiten SAP-Systems, an das nun auch die SÜSS MicroTec Photonic Systems Inc. (Corona, USA) angeschlossen ist, sowie die Einführung einer neuen CAD-Software.

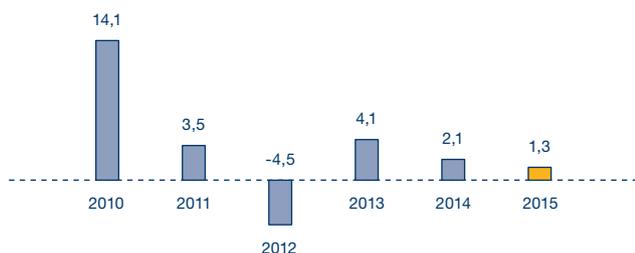
Der freie Cashflow belief sich damit – vor Berücksichtigung von Wertpapiererwerben und -verkäufen – auf 1,3 Mio. €. Im Vorjahr wurde ein freier Cashflow (bereinigt um die Effekte aus Wertpapiererwerben und -verkäufen) von 2,1 Mio. € erzielt.

Der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit belief sich auf -1,2 Mio. € (Vorjahr: -1,2 Mio. €) und resultiert aus den geleisteten Tilgungen für die beiden Bankdarlehen der SÜSS MicroTec AG, die der Finanzierung der beiden Betriebsgrundstücke Garching und Sternenfels dienen.

Neben liquiden Mitteln und verzinslichen Wertpapieren in Höhe von 49,1 Mio. € (Vorjahr: 48,3 Mio. €) verfügt der Konzern zum Ende des Berichtsjahres über inländische Aval- und Kreditlinien von 9,0 Mio. € (Vorjahr: 8,0 Mio. €). Die Linie wurde im Berichtsjahr ausschließlich in Form von Avalen in Anspruch genommen. Der wesentliche Teil davon entfällt auf Anzahlungsbürgschaften. Zum Bilanzstichtag betrug die Inanspruchnahme 5,4 Mio. €.

Ein Bankenkonsortium unter Führung der Deutsche Bank AG und unter Beteiligung der DZ Bank AG und der Baden-Württembergischen Bank stellt Kredit- und Avallinien in Höhe von 4,5 Mio. €. Diese Linien wurden bis auf weiteres gewährt und wurden ohne Covenants gestellt. Die Deutsche Bank gewährte darüber hinaus eine bis zum 30. April 2016 befristete Avallinie in Höhe von 1,0 Mio. €. Die Linien können von der SÜSS MicroTec AG oder der SÜSS MicroTec Lithography GmbH in Anspruch genommen werden.

Free Cashflow in Mio. €



Nettoliiquidität in Mio. €



Zwischen der SUSS MicroTec Photomask Equipment GmbH & Co. KG und der Baden-Württembergischen Bank Mannheim besteht ein Rahmenkreditvertrag, mit dem eine Kreditlinie in Höhe von 1,0 Mio. € gestellt wird. Die Kreditlinie läuft auf unbestimmte Zeit und wurde ohne Covenants gestellt.

Bei einer Versicherungsgesellschaft besteht im Zusammenhang mit einem Kautionsversicherungsvertrag ein Bürgschaftsrahmen in Höhe von 2,5 Mio. €. Der Kautionsversicherungsvertrag läuft bis auf weiteres. Zur Sicherung dieser Linie wurde ein Festgeldkonto in Höhe von 0,3 Mio. € an die Versicherungsgesellschaft abgetreten.

Der Konzern verfügt insgesamt über genügend finanziellen Spielraum, notwendige Produktentwicklungen oder andere strategische Aktivitäten zu finanzieren.

Neben dem Geschäfts- oder Firmenwert bestimmen im Wesentlichen die durch Unternehmensakquisition erworbene Technologie der SUSS MicroTec Photonic Systems sowie die Betriebsgrundstücke in Garching und in Sternenfels die langfristigen Vermögenswerte.

Der Geschäfts- oder Firmenwert beträgt 15,8 Mio. € (Vorjahr: 15,5 Mio. €). Ein Teil des Goodwills (2,4 Mio. USD) wird in US-Dollar geführt und unterliegt daher Währungsschwankungen. Der gesamte Geschäfts- oder Firmenwert ist dem Segment Lithografie zugeordnet.

Die aktivierten Entwicklungskosten weisen zum 31. Dezember 2015 einen Buchwert von 0,3 Mio. € (Vorjahr: 0,4 Mio. €) auf, der komplett dem Segment Lithografie zuzuordnen ist. Sie spielen für die Vermögenslage des Konzerns nur noch eine untergeordnete Rolle.

Darüber hinaus enthalten die langfristigen Vermögenswerte Lizenzen und Patente sowie das bei der SÜSS MicroTec AG aktivierte SAP-System, deren Buchwerte sich auf 2,8 Mio. € (Vorjahr: 2,7 Mio. €) summieren. Sie entfallen in Höhe von 1,5 Mio. € (Vorjahr: 1,5 Mio. €) auf die Segmente Lithografie, Substrat Bonder und Fotomasken Equipment sowie in Höhe von 1,3 Mio. € (Vorjahr: 1,2 Mio. €) auf das Segment Sonstige. Unter den immateriellen Vermögenswerten ist außerdem die im Rahmen der Photonic Systems-Akquisition erworbene Technologie ausgewiesen, die zum Stichtag einen Restbuchwert von 1,2 Mio. € (Vorjahr: 1,4 Mio. €) aufwies und dem Segment Lithografie zugeordnet ist. Die Technologie dotiert in US-Dollar und wird planmäßig über acht Jahre abgeschrieben.

Größten Anteil am konzernweiten Sachanlagevermögen haben die beiden Betriebsgrundstücke in Garching und Sternenfels, die zum Jahresende einen Restbuchwert von 13,8 Mio. € (Vorjahr: 13,7 Mio. €) aufwiesen. Dort sind die SUSS MicroTec Lithography GmbH, die SUSS MicroTec Photomask Equipment GmbH & Co. KG sowie die SÜSS MicroTec AG ansässig.

Das übrige Sachanlagevermögen ist von geringerer Bedeutung für die Vermögenslage des Konzerns, da die Gruppe auf kostenintensive Produktionsanlagen in der Regel nicht angewiesen ist. Die Investitionen beliefen sich (ohne Grund und Boden bzw. Gebäude) im Berichtsjahr auf 2,1 Mio. € im Vergleich zu 1,3 Mio. € im Vorjahr.

Der Buchwert des Sachanlagevermögens hat sich im Vergleich zum Vorjahr nur unwesentlich verändert.

Die latenten Steueransprüche betragen zum Stichtag 2,5 Mio. € nach 3,9 Mio. € im Vorjahr. Sie reduzierten sich im Wesentlichen durch die Nutzung von aktiven latenten Steuern auf Verlustvorträge. Die ertragsteuerliche Organschaft in Deutschland (mit der SÜSS MicroTec AG als Organträger und den Organgesellschaften SUSS MicroTec Lithography GmbH und SUSS MicroTec REMAN GmbH) hat 2015 ein deutlich positives Ergebnis erzielt und nutzt damit einen Teil der im Vorjahr entstandenen Verlustvorträge. Es ist davon auszugehen, dass die deutschen Gesellschaften die noch verbleibenden Verlustvorträge im kommenden Jahr 2016 vollständig nutzen werden. Für die Verlustvorträge der US-Gesellschaften wurden hingegen – unter Berücksichtigung der aktuellen Konzernplanung – keine aktiven latenten Steuern auf Verlustvorträge angesetzt.

Die kurzfristigen Vermögenswerte sind im Berichtsjahr um 10,6 Mio. € auf 133,8 Mio. € angestiegen. Der Anstieg ist hauptsächlich auf den stark gestiegenen Bestand an Vorratsvermögen zurückzuführen. Um dem hohen Auftragsbestand Rechnung zu tragen, haben alle produzierenden Gesellschaften des Konzerns zum Jahresende verstärkt Materialien eingekauft.

Die Vorräte erhöhten sich von 58,9 Mio. € zum Vorjahresstichtag auf 68,7 Mio. € zum Jahresende. Der Anstieg ist im Wesentlichen auf den deutlich höheren Bestand an Materialien und Hilfsstoffen zurückzuführen, bei denen ein Zuwachs um 6,5 Mio. € auf 28,6 Mio. € zu verzeichnen war. Auch der Bestand an unfertigen Erzeugnissen und Fertigerzeugnissen erhöhte sich um 1,4 Mio. € bzw. 1,9 Mio. €, während sich der Bruttobestand an Demonstrationsgeräten um rund 0,5 Mio. € reduzierte.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen reduzierten sich im Vergleich zum Vorjahr von 13,4 Mio. € auf 13,1 Mio. €. Der Rückgang ist im Wesentlichen stichtagsbedingt.

Der SÜSS MicroTec Konzern wies zum 31. Dezember 2015 keine Wertpapiere aus. Im Vorjahr belief sich der Bestand an Wertpapieren noch auf 1,0 Mio. €. Der Bestand an liquiden Mitteln erhöhte sich von 47,3 Mio. € auf 49,1 Mio. €.

Der Anstieg der sonstigen Vermögenswerte von 1,7 Mio. € im Vorjahr auf 2,3 Mio. € zum Jahresende ist im Wesentlichen auf höhere Umsatzsteuerforderungen zurückzuführen, die sich stichtagsbedingt ergeben haben.

Die langfristigen Schulden reduzierten sich von 13,9 Mio. € auf 13,1 Mio. €. Größten Anteil an den langfristigen Schulden haben die Finanzverbindlichkeiten, die sich im Geschäftsjahr auf 7,9 Mio. € (Vorjahr: 9,1 Mio. €) beliefen. Neben dem langfristigen Teil des Darlehens Sternenfels wird hier auch der langfristige Teil des Darlehens ausgewiesen, das der Grundstücksfinanzierung Garching dient. Unter den langfristigen Schulden werden zudem die Pensionsverpflichtungen des SÜSS MicroTec-Konzerns ausgewiesen, für die zum Jahresende ein Betrag von 5,1 Mio. € (Vorjahr: 4,8 Mio. €) passiviert war.

Bei den kurzfristigen Schulden war ein deutlicher Anstieg von 38,0 Mio. € im Vorjahr auf 45,4 Mio. € zum Bilanzstichtag zu verzeichnen. Größten Anteil an diesem Anstieg hatte der Stand der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, die sich zum Jahresende auf 8,5 Mio. € (Vorjahr: 3,4 Mio. €) beliefen. Der Anstieg ist im Wesentlichen stichtagsbedingt. Darüber hinaus sind auch die Steuerschulden von 1,5 Mio. € im Vorjahr auf 3,3 Mio. € zum Jahresende angestiegen. Die sonstigen Verbindlichkeiten haben sich von 22,8 Mio. € im Vorjahr auf 23,5 Mio. € erhöht. Neben abgegrenzten Personalkosten sind in dem Betrag auch die erhaltenen Kundenanzahlungen enthalten, die sich zum Geschäftsjahresende auf 18,2 Mio. € (Vorjahr: 18,0 Mio. €) beliefen.

Das Eigenkapital des SÜSS MicroTec-Konzerns hat sich seit dem 31. Dezember 2014 um 2,7 Mio. € auf 118,7 Mio. € erhöht. Die Eigenkapitalquote sank aufgrund der erhöhten Bilanzsumme im Jahresvergleich von 69,1 % auf 67,0 %.

INVESTITIONEN

Gezielte Investitionen stärken das Unternehmen

Die SÜSS MicroTec AG ist Eigentümerin der Betriebsgrundstücke in Garching und Sternenfels, an denen der Firmensitz sowie die Betriebe der SÜSS MicroTec Lithography GmbH und der SÜSS MicroTec Photomask Equipment GmbH & Co. KG ihren Sitz haben. Die SÜSS MicroTec AG investiert laufend in die Betriebsgebäude an den beiden Standorten, um die Lagerräume sowie die Produktions- und Verwaltungsräume auf dem neuesten technischen Stand zu halten.

Bedingt durch die Struktur des Unternehmens sind Investitionen in technische Anlagen und Maschinen keine wesentliche Komponente in der Unternehmensentwicklung. Die wesentliche Wertschöpfung entsteht durch Design, Montage und Justage der Komponenten sowie der entsprechenden Softwaresteuerung. Für diese Tätigkeiten sind keine besonderen Anlagen und Maschinen erforderlich.

Wir gehen davon aus, dass sich die Investitionen in Sachanlagen langfristig in einem Bereich von ca. 1 bis 2 % des Umsatzes bewegen werden. Eine Ausnahme stellt nur die in dem Segment Sonstige enthaltene Produktlinie Mikrooptik dar. In dieser Produktlinie wird Kleinserienfertigung betrieben, für die entsprechende Fertigungsmaschinen notwendig sind.

Für Entwicklungsleistungen, die nach IFRS die Voraussetzungen zur Aktivierung erfüllen, werden immaterielle Vermögenswerte erfasst. Ein Teil der Investitionen ist daher dem Bereich immaterielle Vermögenswerte zuzuordnen.

Eigenkapital in Mio. € und **Eigenkapitalquote**



Die SÜSS MicroTec AG ist Eigentümerin des konzernweiten SAP-Systems, das sowohl von den deutschen Gesellschaften als auch von der SUSS MicroTec, Inc. (Corona, USA) und von der SUSS MicroTec (Taiwan) Company Ltd. (Hsinchu, Taiwan) genutzt wird. 2015 wurde die SUSS MicroTec Photonic Systems (Corona, USA) erfolgreich an das konzernweite SAP-System angeschlossen.

FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG

Die Forschungs- und Entwicklungsausgaben erhöhten sich von 10,5 Mio. € im Vorjahr auf 12,8 Mio. €, was im Geschäftsjahr 2015 in Relation zum Umsatz einer Aufwandsquote von 8,6 % (Vorjahr: 7,2 %) entspricht. Sie betrafen mit 8,0 Mio. € (Vorjahr: 6,9 Mio. €) das Segment Lithografie und mit 2,2 Mio. € (Vorjahr: 1,5 Mio. €) das Segment Substrat Bonder. 1,9 Mio. € (Vorjahr: 1,6 Mio. €) waren dem Segment Fotomaschinen Equipment zuzuordnen.

Ende 2015 waren 147 Mitarbeiter – und damit fast jeder fünfte Mitarbeiter von SÜSS MicroTec – im Bereich Forschung und Entwicklung tätig (Vorjahr: 128 Mitarbeiter).

Lithografie

Das größte Segment vereinigt die Produktlinien Exposure (Mask Aligner, UV-Projektionsgeräte), Laser Processing sowie Belacker und Entwickler.

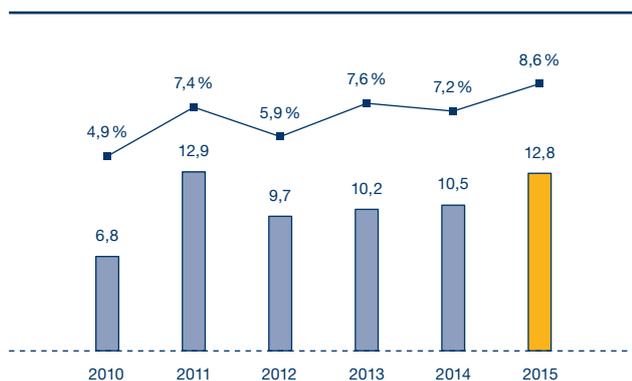
Die Belacker- und Entwickler-Produktgruppe fokussierte ihre Forschungs- und Entwicklungsarbeiten im Jahr 2015 auf drei wesentliche Schwerpunkte. Zunächst wurden sowohl für die automatisierte 200 mm, als auch die 300 mm Geräteplattform gezielte Verbesserungen der vorhandenen Basis-Systeme entwickelt. So wurde in der 200 mm Anlage beispielsweise die Luftströmung in den Belackermodulen optimiert, was einerseits zu verbesserten Prozessergebnissen, andererseits zu reduzierten

Betriebskosten aufgrund niedrigerer Anforderungen an die Abluftanlage beim Kunden führt. Die Implementierung eines neuen Handhabungs-Systems in der ACS300 Gen2 verbessert den Durchsatz der Anlage und führt somit ebenfalls zu optimierten Betriebskosten der Anlage. Auch die Servicefreundlichkeit wurde durch Detailverbesserungen optimiert und bringt beide Plattformen auf höchsten Standard.

Daneben wurde ein von Grund auf neues Dispens-System für Chemikalien entwickelt. Bisher mussten sich Kunden für komplexe und somit kostenintensive Pumpenlösungen für höchste Dosier- und Wiederholgenauigkeiten oder einfach aufgebaute druckbasierte Systeme entscheiden. Auf Basis eines druckbasierten Systems wurden Kontroll- und Messmöglichkeiten an prozessrelevanten Stellen hinzugefügt. In Kombination mit intelligenten Kontrollalgorithmen konnte so ein System mit der Einfachheit eines druckbasierten Dispens-Systems bei gleichzeitiger Dosier- und Wiederholgenauigkeit eines Pumpen-Systems geschaffen werden.

Als weiteres Schwerpunktthema wurde die Software der Produktionsanlagen optimiert und erweitert. Eine Kernkomponente und stark durchsatzbestimmend ist der sogenannte Scheduling Algorithmus. Dieser plant alle Transporte der Substrate in der Anlage zu und von den verschiedenen Prozessmodulen und stellt sicher, dass diese optimal ausgelastet sind. Durch intensive Untersuchungen und Arbeiten konnte eine neue Softwarekomponente entwickelt werden, die der Forderung nach höchstmöglichem Durchsatz bei gleichzeitiger Prozessflexibilität gerecht wird. Die Entwicklungsarbeiten stellen ebenfalls sicher, dass das bereits erwähnte neue Handhabungs-System der ACS300 Gen2 optimal genutzt wird.

Forschungs- und Entwicklungsaufwand (F+E) in Mio. € und F+E Quote in % vom Umsatz



Bereits im Geschäftsjahr 2014 hat die Produktlinie Mask Aligner mit der MA200 Gen3 eine neue Maschinengeneration des Vollautomaten auf den Markt gebracht. Ziel ist es, den Kunden eine stetige Verbesserung der Cost-of-Ownership bieten zu können. Im Verlauf des Geschäftsjahres 2015 konnte der Durchsatz erneut deutlich erhöht werden. Im Rahmen der permanenten Produktweiterentwicklung wurden die Prozesse für die Hochvolumenproduktion stabilisiert. Neue Digitalkameras und verbesserte Mikroskope ermöglichen eine deutlich höhere Auflösung und bessere Bildqualität für die Justiermarkenerkennung. So können Maske und Wafer nun noch genauer zueinander ausgerichtet werden. Dieser für den Kunden bedeutsame Qualitätsparameter „Overlay“ ist besonders für die Herstellung von komplexen Strukturen mit vielen Belichtungsschritten entscheidend. Zudem sind die Kameras deutlich empfindlicher, so dass selbst schlecht sichtbare Strukturen/Marken auch ohne den Einsatz von Spezialausrüstungen möglich sind.

Im Bereich der 200mm Wafer Bearbeitung besteht weiterhin ein reges Interesse an der Handhabung von stark gebogenen Wafern, welches insbesondere durch die MA200 Gen3 abgedeckt wird. Bei 300mm Wafern ist die Handhabung von stark gebogenen besonders bei der Herstellung von Bildsensoren wichtig. Durch umfangreiche Weiterentwicklungen an der MA300 und ihren Spezialwerkzeugen sowie der Softwareprozesse können nun auch hier stark gebogene Wafer zuverlässig verarbeitet werden.

Kameras, die auf Wafer-Ebene hergestellt wurden, finden sich heute in nahezu allen Mobiltelefonen und anderen mobilen Geräten wie Touchpads und Laptops. Diese Kameras bestehen aus zwei Hauptkomponenten: dem CMOS-Bildsensor und der sogenannten Optik auf Wafer-Ebene (Wafer-Level Optics – WLO). Einen wichtigen Bestandteil der Optiken stellen kleine Linsen dar. Dieser technologisch anspruchsvolle Spezialbereich hat ein großes Marktpotenzial für SÜSS MicroTec. In Zusammenarbeit mit Leitkunden wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr neuartige Prozesse und Spezialwerkzeuge für die MA/BA8 Gen3 entwickelt. Ziel ist es, die nächste Generation von Wafer-Level Optics-Technologien zu entwickeln, die die kundenspezifische Integration von optischen Bauelementen in Halbleiterprozesse ermöglicht.

Die SELECT-Funktionalität zur selektiven Plasmabehandlung wird insbesondere zur Vorbereitung der Wafer zum Bonden verwendet. Diese innovative Funktionalität für die MA/BA8 Gen3, Mask- und Bond Aligner ist nun auch für Wafer mit einem Durchmesser bis 200mm verfügbar.

Im Geschäftsjahr 2015 hat sich die wesentliche Entwicklungsarbeit am Standort Corona auf die Weiterentwicklung der UV-Projektionsscannertechnologie fokussiert. So konnten beim Projektionsscanner DSC300 Gen2 deutliche Durchsatzsteigerungen von bis zu 50% erreicht werden. Damit können wir unseren Kunden zukünftig eine deutlich verbesserte Cost-of-Ownership bieten. Im Jahresverlauf wurden bei der DSC300 Gen2 zudem erweiterte Automatisierungsfunktionen, wie beispielsweise ein automatischer Blendenwechsler zur Optimierung der Optik, entwickelt und in die Maschine integriert. Darüber hinaus lag der wesentliche Fokus der Produktlinie auf der Prozessqualifizierung und Optimierung des Gerätes im Hinblick auf die Wachstumsfelder Copper-pillar bumping und Fan-out Wafer-Level Packaging. Dank der umfassenden Weiterentwicklung der DSC300 Gen2 sowie der Verbesserung verschiedener Prozessabläufe ist es uns gelungen, einen ersten großen Kunden zu gewinnen, der die Scannertechnologie in der Volumenfertigung einsetzen wird.

Substrat Bonder

Das Segment untergliedert sich in die beiden Teilbereiche temporäres und permanentes Bonden.

Im Bereich permanentes Bonden wurde im Geschäftsjahr 2015 ein neuer halbautomatischer Wafer Bonder entwickelt und in den Markt eingeführt. Das halbautomatische System XB8 kann Wafergrößen bis 200mm sowie verschiedene Substratgrößen und -typen bearbeiten und basiert auf der Steuerungsplattform des im Jahr 2014 entwickelten SB6/8 Gen2 Wafer Bonders. Im Gegensatz zu den bis zu 20kN Bondkraft, welche der SB6/8 Gen2 bietet, kann der neue XB8 Bonder bis zu 60kN beziehungsweise 100kN Bondkraft bei Verwendung von 200mm Wafern aufbringen. Derart hohe Bondkräfte sind sowohl für aktuelle Thermokompressionsbondprozesse, beispielsweise Kupfer-zu-Kupfer-Bondverbindungen wie sie für Anwendungen in MEMS und der 3D-Integration eingesetzt werden, aber auch für andere metallische Bondprozesse notwendig, bei denen die Anzahl der Sensoren je Wafer und damit auch der Anteil der zu verbindenden Metallflächen zunimmt. Neben der Möglichkeit sehr hohe Bondkräfte aufzubringen verfügt der XB8 Wafer Bonder über ein doppelseitiges, symmetrisch aufgebautes keramisches Heizer-System mit aktiver Kühlung, welches für Temperaturen von bis zu 550°C ausgelegt ist und damit die Anforderungen heutiger und zukünftiger Prozessanforderungen aus den Bereichen MEMS, LED und der 3D-Integration abdeckt.

Im Bereich temporäres Bonden konnte die Marktposition im Bereich der TSV-basierten 3D-Speicherchips weiter gefestigt werden, in dem wir einen zweiten asiatischen Produktionskunden für einen Teil unserer Gerätelösung gewinnen konnten. Die für diesen Kunden entwickelten Detailverbesserungen an einzelnen Prozessmodulen wurden nach der Kundenqualifikation

in die Serie übernommen. Darüber hinaus wurden Entwicklungsprojekte für eine optimierte Sequenzsteuerung am temporären Bonder, welche zur Verbesserung der Bedienerfreundlichkeit, der Stabilität und des Durchsatzes führt, sowie Hardwareverbesserungen zur Erhöhung der Prozessflexibilität und einer erweiterten Parameterüberwachung am Debonder in enger Abstimmung mit dem bestehenden asiatischen Schlüsselkunden durchgeführt. Die daraus resultierenden Verbesserungen wurden auf den bei einem Kunden bereits in den Vorjahren installierten Geräten zur 3D-Speicherchip-Herstellung nachgerüstet und qualifiziert.

Der Fokus auf der Applikationsseite lag im abgelaufenen Geschäftsjahr neben den Entwicklungspartnerschaften mit externen Forschungsinstituten wie dem imec, bei denen neuartige Prozesse und Material-Systeme auf unseren temporären Bondern qualifiziert werden, auf der direkten Kooperation mit Materialherstellern, um Prozessabläufe effizienter und damit kostengünstiger zu gestalten. In Zusammenarbeit mit einem asiatischen Materialhersteller wurde mit der Qualifikation einer neuartigen Trennschicht zum mechanischen Debonden für ein bereits in Produktion befindliches Material-System begonnen. Diese neue Trennschicht ermöglichte eine Vereinfachung des Prozessablaufes und eröffnet damit Kostenvorteile im Vergleich zum aktuell eingesetzten Prozess. In Zusammenarbeit mit einem amerikanischen Materialhersteller wurden neuartige Trennschichten für das Excimerlaser-basierte Debonden auf unserem ELD300 optimiert und für unterschiedliche Kundenanwendungen aus dem 3D-Packaging-Bereich erfolgreich getestet.

Fotomasken Reinigung

Die Einführung von EUVL (Extreme Ultraviolett Lithography) für die Großserienproduktion in der Halbleiter-Industrie ist nach wie vor verzögert. Für die Industrie bedeutet das, dass die 193i Immersions-Lithographie im Mehrfachbelichtungsverfahren (Double Patterning und Quadruple Patterning) weiter ausgebaut und infolgedessen auch die damit unmittelbar verknüpften Verfahrenstechniken, wie z. B. die Fotomaskenreinigung, angepasst und erweitert werden müssen.

Im Jahr 2015 lag im Segment Fotomasken Equipment der Fokus auf sogenannten auf Megasonic basierenden Technologien. Insbesondere die Integration und Qualifizierung einer flächenbasierenden Ultraschallanwendung konnte in Kooperation mit einem wichtigen koreanischen Kunden umgesetzt und im Anschluss in das Standard-Produktportfolio übernommen werden. Auch die bei SUSS MicroTec seit Jahren im Einsatz befindliche Standard-Megasonic-Anwendung konnte nun erfolgreich im hochfrequenten Bereich getestet werden und findet sich nun ebenfalls bereits mehrfach in Kundenanlagen integriert.

Neben den für die Fotomaskenreinigung kritischen Parametern wie Partikelgröße und Wirkungsgrad, spielt auch der Erhalt der optischen Eigenschaften eine wesentliche Rolle. Transmissions- und Reflexionsgrad sowie die Veränderung der kritischen Strukturbreitenverteilung auf Photomasken werden stark durch die Verwendung von konventionellen nasschemischen Verfahren beeinflusst. Schonende Trockenreinigungs- und Oberflächenbehandlungsmethoden schaffen hier weitere Möglichkeiten.

Die Entwicklung einer speziellen Plasma-Einheit war bereits Teil der Entwicklung im Jahr 2014 und wurde in einer existierenden MaskTrack PRO-Anlage bei einem taiwanesischen Kunden integriert. Im Jahr 2015 erfolgte die Qualifizierung dieser Einheit. Die Verwendung von Plasma unter Atmosphärendruck bietet hier ganz besonders viele Vorteile, da es neben dem Reinigungseffekt zusätzlich Einfluss auf die Oberflächenenergie ausübt und dadurch die Benetzbarkeit für anschließende Nassprozesse verbessert. Zudem wird mittels Plasma im Anschluss an die finale Reinigung eine Passivierung der Oberfläche erreicht.

Im Bereich von EUVL wurde offiziell das europäische Förderprojekt SeNaTe (Seven Nanometer Technologie) gestartet, bei dem auch SUSS MicroTec Projektpartner und für den Bereich Fotomaskenreinigung verantwortlich ist.

Die Holding – SÜSS MicroTec AG

Die Aufgabe der Holding ist die Steuerung und Führung des SÜSS MicroTec-Konzerns. Sie übernimmt unter anderem die Aufgaben der strategischen Ausrichtung, beispielsweise der Ausweitung des Produktportfolios, Akquisitionen und Finanzfragen der gesamten Gruppe. Ebenso ist die Holding für Corporate Identity, Investor Relations, Marketing und IT verantwortlich. Darüber hinaus übernimmt die Holding die Finanzierung von strategisch bedeutsamen Entwicklungsprojekten der operativen Tochtergesellschaften.

Die SÜSS MicroTec AG ist in der Regel alleinige Anteilseignerin an den im Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen. Ausleihungen der Holding erfolgten nur an Tochterunternehmen und deren Tochterunternehmen. Die Ertragslage der Holding als Einzelgesellschaft ist nicht direkt von der Entwicklung unserer Märkte abhängig. Die Holding refinanziert sich im Wesentlichen durch Umlage der umlagefähigen Kosten auf die operativen Gesellschaften, durch Vermietung der Gebäude an den Standorten Garching und Sternenfels an Tochtergesellschaften, durch Zinserträge aus den Ausleihungen an Tochterunternehmen sowie durch bestehende Ergebnisabführungsverträge.

Darstellung der finanziellen Kennzahlen der Holding

in Tsd. €	SMT AG (HGB)			
	2015	2014	Änderung	in %
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-8.491	6.980	-15.471	-
Eigenkapital (EK)	87.648	96.139	-8.491	-9
Bilanzsumme	137.668	139.443	-1.775	-1
EK-Quote in %	64	69		
Anlagevermögen	81.885	82.751	-866	-1
% der Bilanzsumme	59	59		
Umlaufvermögen inkl. ARAP	55.784	56.692	-908	-2
% der Bilanzsumme	41	41		

WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN DER VERMÖGENS- UND FINANZLAGE

Die immateriellen Vermögensgegenstände belaufen sich zum Stichtag unverändert auf 1,6 Mio. €.

Die Anteile an verbundenen Unternehmen sind zum Bilanzstichtag mit 51,7 Mio. € bilanziert und sind damit um 1,2 Mio. € geringer als im Vorjahr. Grund für den Rückgang sind außerplanmäßige Abschreibungen auf die Beteiligung an der SÜSS MicroTec, Inc., Corona (USA). Die Gesellschaft, die ursprünglich einen operativ tätigen Produktionsbetrieb aufwies, fungiert inzwischen lediglich als Vertriebsgesellschaft und weist dementsprechend eine

für eine Vertriebsgesellschaft übliche geringe EBIT-Marge aus. Entsprechend zeigt das zur Überprüfung der Werthaltigkeit von Finanzanlagen verwendete Modell eine Abwertung auf den Beteiligungsansatz an dieser Gesellschaft um rund 1,2 Mio. € an.

Die Ausleihungen an verbundene Unternehmen stiegen um rund 0,3 Mio. €. An die SÜSS MicroTec Photonic Systems Inc., Corona, USA, wurden weitere Darlehensbeträge ausgereicht. Zum 31. Dezember 2015 belief sich das Darlehen auf insgesamt 38,5 Mio. USD (Vorjahr: 22,6 Mio. USD). Da für die SÜSS MicroTec Photonic Systems auf Basis der aktuellen Konzernplanung ein negatives Ergebnis erwartet wird, zeigt das zur Überprüfung der Werthaltigkeit von Finanzanlagen verwendete Modell eine Abwertung dieses Gesellschafterdarlehens um rund 14,1 Mio. € an. Das Darlehen wurde entsprechend zum 31. Dezember 2015 um diesen Betrag abgewertet. Auch das an die SÜSS MicroTec KK, Yokohama, Japan, gewährte Darlehen, das sich auf 775 Mio. JPY (Vorjahr: 600 Mio. JPY) beläuft, wurde aufgrund verhaltener Ertragsaussichten der Gesellschaft abgewertet. Der zum 31. Dezember 2015 erfasste Abwertungsbetrag beläuft sich auf 1,7 Mio. €.

Die kurzfristigen Forderungen gegen verbundene Unternehmen stiegen um 0,4 Mio. € auf 14,9 Mio. € an. Der Anstieg ist im Wesentlichen stichtagsbedingt. In diesem Betrag sind die Forderungen aus den Ergebnisabführungen der SÜSS MicroTec Lithography GmbH und der SÜSS MicroTec Reman GmbH sowie der phasengleichen Gewinnvereinbarung der SÜSS MicroTec Photomask Equipment GmbH & Co. KG enthalten.

Im Berichtsjahr sank die Liquiditätsposition der SÜSS MicroTec AG um 1,2 Mio. €. Die Reduzierung der Liquiditätsposition wird im Rückgang der Guthaben bei Kreditinstituten in Höhe von 0,2 Mio. € sichtbar. Der Bestand an Wertpapieren ist um 1,0 Mio. € auf 0 € zurückgegangen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen stiegen im Geschäftsjahr um 6,8 Mio. € auf 36,3 Mio. € an.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sanken im Verlauf des Jahres 2015 um 1,2 Mio. €. Dies resultiert aus planmäßigen Tilgungen eines Darlehens zur Finanzierung des Betriebsgrundstücks in Sternenfels und eines Darlehens zur Finanzierung des Betriebsgrundstückes in Garching.

Aufgrund des negativen Jahresergebnisses reduzierte sich das Eigenkapital der Gesellschaft von 96,1 Mio. € auf 87,6 Mio. €.

WESENTLICHE EREIGNISSE MIT EINFLUSS AUF DIE ERTRAGSLAGE DER HOLDING

Im handelsrechtlichen Jahresabschluss der SÜSS MicroTec AG ergab sich für das Geschäftsjahr 2015 ein Jahresfehlbetrag von 8,5 Mio. € (Vorjahr: Jahresüberschuss 7,0 Mio. €).

Die Umsatzerlöse der Holding beliefen sich auf 6,6 Mio. € (Vorjahr: 5,5 Mio. €) und umfassten im Wesentlichen die den Tochtergesellschaften in Rechnung gestellten Umlagen für Managementleistungen, Marketing und Versicherungen. Darüber hinaus waren in den Umsatzerlösen auch Weiterbelastungen für das konzernweite SAP-System und Lizenzgebühren enthalten.

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind überwiegend Mieterlöse in Höhe von 1,8 Mio. € (Vorjahr: 1,9 Mio. €) und Fremdwährungsgewinne in Höhe von 0,8 Mio. € (Vorjahr: 0,2 Mio. €) enthalten.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten – neben laufenden Aufwendungen für die Verwaltung – Fremdwährungsverluste in Höhe von 0,8 Mio. € (Vorjahr: 4,6 Mio. €).

Aufgrund des seit 1. Januar 2011 gültigen Ergebnisabführungsvertrages mit der SUSS MicroTec Lithography GmbH, Garching, wurde bei der Holding ein Ertrag aus Gewinnübernahme in Höhe von 6,3 Mio. € (Vorjahr: 8,8 Mio. €) ertragswirksam erfasst. Aufgrund des im Geschäftsjahr 2008 geschlossenen Ergebnisabführungsvertrages mit der SUSS MicroTec REMAN GmbH, Oberschleißheim, wurde bei der Holding ein Ertrag aus Gewinnübernahme in Höhe von 1,4 Mio. € (Vorjahr: 1,1 Mio. €) erfasst. Weiterhin wurden aus der phasengleichen Ergebnisvereinnahmung der SUSS MicroTec Photomask Equipment GmbH & Co. KG Beteiligungserträge von 1,8 Mio. € (Vorjahr: 0 €) gebucht. Darüber hinaus hat die Holding aus einer Dividendenausschüttung der SUSS MicroTec (Taiwan) Company Ltd., Hsin Chu (Taiwan) Beteiligungserträge von rund 0,7 Mio. € erzielt.

Die Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens umfassten die Zinserträge für die langfristigen Darlehen, die den Tochtergesellschaften SUSS MicroTec Photonic Systems Inc. (Corona, USA) und SUSS MicroTec KK (Yokohama, Japan) gewährt wurden.

Auf die Finanzanlagen wurden außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 16,9 Mio. € (Vorjahr: 6,9 Mio. €) vorgenommen. Davon entfielen 1,2 Mio. € auf die Beteiligung an der SUSS MicroTec, Inc. (Corona, USA) sowie 14,1 Mio. € bzw. 1,7 Mio. € auf Darlehen, die der SUSS MicroTec Photonic Systems Inc. (Corona, USA) bzw. der SUSS MicroTec KK (Yokohama, Japan) gewährt wurden.

Im Vorjahr erzielte die SÜSS MicroTec AG aus der Tilgung eines Gesellschafterdarlehens, das in der Vergangenheit der SUSS MicroTec Photomask Equipment GmbH & Co. KG gewährt wurde, einen Gewinn von 7,6 Mio. €.

Die Zinsaufwendungen stiegen im Geschäftsjahr leicht um 0,1 Mio. €, was im Wesentlichen auf erhöhte Zinsen für verbundene Unternehmen zurückzuführen ist.

In der SÜSS MicroTec AG waren im Geschäftsjahr 2015 durchschnittlich 18 (Vorjahr: 19) Mitarbeiter tätig.

Die kurz- und mittelfristige Entwicklung der SÜSS MicroTec AG hängt vor allem von der Entwicklung der Finanz- und Ertragslage wesentlicher Tochtergesellschaften ab. Die Finanz- und Ertragslage der Tochtergesellschaften ist ausschlaggebend für die Höhe des zinstragenden Nettofinanzierungssaldos der Holding und für die Ausschüttung und Abführung von Ergebnissen an die Muttergesellschaft. Zudem ist das Ergebnis beeinflusst von Fremdwährungseffekten, die sich im Wesentlichen aus der Veränderung der Wechselkurse von USD und JPY ergeben.

Der Geschäftsverlauf, die Lage sowie die voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken der SÜSS MicroTec AG als Holding unterscheiden sich nicht grundsätzlich vom Konzern. Der Jahresabschluss der SÜSS MicroTec AG wird jedoch von Bewertungseffekten im Bereich des Finanzanlagevermögens beeinflusst.

Nachhaltigkeit

Seit mehr als sechzig Jahren ist SÜSS MicroTec in der Fertigung von Anlagen und der Entwicklung von Prozesslösungen für Mikrostrukturanwendungen tätig. In unserem schnellebigen und von kurzen Innovationszyklen geprägten Geschäftsumfeld ist es notwendig, stets neue Lösungen für die Kunden zu entwickeln. Dennoch schließt sich ökologisches und ökonomisches Denken nicht aus. Nachhaltiges Wirtschaften ist ein wichtiger Erfolgsfaktor, welcher bei uns eine sehr hohe Priorität genießt. Als Technologieführer und Innovationstreiber fühlen wir uns nicht nur der Erstklassigkeit unserer Produkte, sondern auch dem Thema Nachhaltigkeit verpflichtet. Es geht bei den Managemententscheidungen immer auch darum, die sozialen, ökologischen und ökonomischen Komponenten in Einklang zu bringen. Ob mit Kunden, Mitarbeitern oder Wettbewerbern – wir streben nach einem fairen und sozial verträglichen Umgang miteinander.

Darüber hinaus legen wir die gleichen hohen Maßstäbe an Zulieferer und Geschäftspartner. Wir sind einer nachhaltigen, wirtschaftlichen Entwicklung verpflichtet und möchten den Leserinnen und Lesern auf den kommenden Seiten einen Überblick über unsere Aktivitäten im Hinblick auf eine nachhaltige Unternehmensentwicklung geben. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Internet unter ► www.suss.com ► **Unternehmen** ► **Qualitätsmanagement** ► **Nachhaltigkeit**.

COMPLIANCE

Jeder Angestellte trägt eine Mitverantwortung für das Erscheinungsbild unseres Unternehmens und dafür, dass unsere gesellschaftliche Verantwortung wahrgenommen wird. Unser Selbstverständnis umfasst zudem die Integration aller Mitarbeiter, unabhängig von Alter, Herkunft, Geschlecht, Behinderung oder Religion. Im Verhaltenskodex sind die Verhaltensregeln für SÜSS MicroTec-Mitarbeiter im Umgang mit Kunden, Zulieferern und anderen Geschäftspartnern sowie der Umgang unter den Mitarbeitern geregelt. Er soll helfen, die zahlreichen rechtlichen und ethischen Herausforderungen bei der täglichen Arbeit zu bewältigen, Orientierung zu schaffen und so das Vertrauen in die Leistung und Integrität der SÜSS MicroTec-Gruppe weiter zu stärken. Die Mitarbeiter verpflichten sich, die Verhaltensregeln des Verhaltenskodex und die Compliance-Regeln zu befolgen. Seit dem Geschäftsjahr 2014 haben wir ein webbasiertes Hinweis-System (Whistleblowing) auf mögliche Compliance-Verstöße installiert. Die Meldungen gehen per E-Mail anonymisiert oder unter freiwilliger Angabe des Namens direkt an die Rechtsabteilung.

Im Geschäftsjahr 2015 haben wir den Verhaltenskodex sowie unser Compliance-Handbuch komplett überarbeitet. Im Geschäftsjahr 2016 werden wir unseren Fokus auf das Thema Compliance weiter verstärken und werden zusätzlich Schulungen für unsere Mitarbeiter durchführen.

QUALITÄTSMANAGEMENT

Die technologisch führende Position von SÜSS MicroTec in den Bereichen Lithografie, Fotomasken Equipment, Substrat Bonder und Mikrooptik fußt auf der starken Verpflichtung zur Einhaltung höchster Qualitätsstandards. Unsere Qualitätsziele basieren auf nachhaltigem Kundenvertrauen, Wertschätzung gegenüber unseren Kunden, Partnerschaften und motivierten Mitarbeitern. SÜSS MicroTec liefert qualitativ hochwertige Produkte und Services sowie innovative Lösungen. Alle Bereiche von SÜSS MicroTec teilen unsere Verpflichtung zu höchster Qualität. Unsere Prozesse basieren auf einem effektiven Qualitätsmanagement-System, das für die Produktionsstandorte in Deutschland und der Schweiz nach ISO 9001 zertifiziert ist und ständig verbessert wird.

UMWELTVERANTWORTUNG

ISO 14001 Zertifizierung

Seit 1996 bildet die Norm ISO 14001 die Grundlage für Aufbau, Einführung, Überwachung und Weiterentwicklung von Umweltmanagement-Systemen. Sie legt entsprechende Forderungen fest, die auf Organisationen jeder Art und Größe sowie auf unterschiedliche geografische, kulturelle und soziale Bedingungen anwendbar sind. Das übergeordnete Ziel ist, den Umweltschutz zu fördern und Umweltbelastungen zu verringern – im Einklang mit wirtschaftlichen, sozialen und politischen Erfordernissen. Die ISO 14001 ist gleichzeitig auch die Grundlage für die Zertifizierung von Umweltmanagement-Systemen.

Bei SÜSS MicroTec beschäftigen wir uns im Rahmen des Umweltmanagements bereits seit 2014 intensiv mit der Vorbereitung auf die ISO 14001:2015 Zertifizierung. Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden die Vorbereitungen zur Systemanalyse sowie die Dokumentation zur Vorabprüfung erstellt. Derzeit befinden wir uns in der Vorbereitungsphase auf die eigentliche ISO-Zertifizierung, welche im Geschäftsjahr 2016 erfolgreich abgeschlossen werden soll. Durch diese Zertifizierung möchten wir auch auf internationaler Ebene ein anerkanntes Umweltmanagement-System vorweisen. Darüber hinaus kommt es während und vor dem eigentlichen Zertifizierungsprozess häufig zur Aufdeckung von Schwachstellen im Umweltmanagement-System sowie zur Aufdeckung von Rationalisierungspotenzial, welches wir zum Vorteil des Unternehmens und seiner Mitarbeiter nutzen wollen. Im Geschäftsbericht 2016 werden wir mehr zu diesem Thema berichten können.

Generalüberholung unserer Maschinen

Mit großer Sorgfalt konstruieren unsere Mitarbeiter unsere Maschinen, die häufig für eine lange Nutzungszeit ausgelegt sind. Eine Lebensdauer von bis zu 15 Jahren oder länger ist keine Seltenheit und liefert einen Beweis für die herausragende Wirtschaftlichkeit. Jahr für Jahr zeigen die Anlagen von SÜSS MicroTec ihre Qualität, Zuverlässigkeit und Belastbarkeit. Mit unserem Tochterunternehmen SÜSS MicroTec REMAN bieten wir unseren Kunden die Möglichkeit, gebrauchte, von uns sorgfältig generalüberholte Maschinen zu einem günstigeren Preis zu erwerben. Damit entlasten wir das Beschaffungsbudget unserer Kunden, verlängern die Lebensdauer gebrauchter Maschinen und sparen wertvolle Ressourcen. Die SÜSS MicroTec REMAN steuert schon seit vielen Jahren einen Beitrag zum Unternehmenserfolg bei.

Umgang mit Chemikalien

Der sorgfältige Umgang mit Chemikalien spielt insbesondere bei unseren Belackern und Entwicklern eine große Rolle. Die fortlaufende Verbesserung unserer Maschinen im Hinblick auf den Verbrauch von Nasschemikalien ist ein wichtiges Ziel unserer Entwicklungsarbeit im Unternehmen. Ein gewisser Einsatz an Nasschemie ist jedoch für die Prozessabläufe in der Halbleiterfertigung bisher zwingend notwendig.

Im Garching Applikationslabor, in dem Testläufe an unseren Maschinen stattfinden, haben wir deshalb eine Neutralisationsanlage zur Abwasserbehandlung installiert, welche den pH-Wert der verschiedenen Chemikalien auf ein verträgliches Niveau anpasst.

Als Spezialmaschinenbauer im Halbleitersegment sind wir mit Produkten am Markt, die maßgeblich dazu beitragen energieeffiziente Endprodukte herzustellen und CO₂-Emissionen zu verringern. Ein Beispiel hierfür ist die Herstellung von energiesparenden Leuchtdioden (LED). Mit dem MA100/150e Gen2

bieten wir eine Mask Aligner-Plattform speziell für die Verarbeitung empfindlicher Verbindungshalbleiter, wie z. B. sehr heller LEDs (UBH).

Darüber hinaus kommen viele Bauelemente (z. B. Hochleistungsschaltkreise), die unter anderem auf unseren Maschinen gefertigt werden, in der Industrie für erneuerbare Energien wie Wind- und Solarenergie zum Einsatz. Aber auch die Verbesserungen der ökologischen Eigenschaften und der Umweltverträglichkeit unserer Produkte selbst sind ein wichtiger Teil unserer Entwicklungsarbeit. So legen wir verstärkt Wert auf einen möglichst geringen Einsatz von Chemikalien und gefährlichen Prozessmaterialien im Fertigungsprozess und während des Betriebs unserer Maschinen. Bei Belackungs- und Entwicklungsgeräten sowie Fotomasken Equipment lässt sich durch innovatives Prozessmanagement und ein ausgeklügeltes Maschinendesign der Verbrauch der verwendeten Medien reduzieren. Dies spart unseren Kunden bares Geld und entlastet die Umwelt.

Stromverbrauch Sternenfels und Garching in MWh



MITARBEITER

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie deren Wissen stellen einen erheblichen Teil unseres Unternehmenswerts dar. Unser Geschäft ist geprägt von Internationalität, globaler Ausrichtung und kultureller Vielfalt. Über den Globus verteilt haben wir Mitarbeiter in Entwicklung, Produktion, Verwaltung, Vertrieb und Service, welche ein wichtiges Netzwerk für den standortübergreifenden Wissensaustausch und die interkulturelle Zusammenarbeit bilden. Wir arbeiten in flachen Hierarchien mit kurzen Entscheidungswegen und ermöglichen unseren Mitarbeitern sich einzubringen und sich entsprechend ihrer Fähigkeiten und Neigungen weiter zu entwickeln. Denn die Motivation, das Wissen und die Flexibilität unserer Mitarbeiter sind eine wichtige Voraussetzung für den langfristigen Unternehmenserfolg.

Zum Ende des Geschäftsjahres 2015 waren 698 (Vorjahr: 659) Mitarbeiter im Konzern beschäftigt. Im gesamten Unternehmen waren zum 31. Dezember 2015 26 Auszubildende in kaufmännischen und technischen Bereichen beschäftigt (2014: 32). Seit jeher arbeitet das Unternehmen eng mit Hochschulen und Forschungseinrichtungen zusammen, um den Namen SÜSS MicroTec möglichst früh an talentierte Absolventen heranzutragen und den Nachwuchs für das erfolgreiche Bestehen des Unternehmens zu sichern.

Wir respektieren die persönliche Würde, die Privatsphäre und die Persönlichkeitsrechte jedes Einzelnen. Die Sicherheit und das Wohlbefinden der Mitarbeiter liegen uns ganz besonders am Herzen. Ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld fördert sowohl die Produktivität als auch das Arbeitsklima im Unternehmen. Wie in unserer Erklärung zu Umwelt, Gesundheit und Sicherheit dargelegt, ([► www.suss.com](http://www.suss.com) ► **Unternehmen** ► **Qualitätsmanagement** ► **Umweltverantwortung**) gibt es spezielle Programme, um

die höchsten Standards im Hinblick auf Sicherheit zu erfüllen. Wir führen an unseren Produktionsstandorten detaillierte Statistiken über Arbeitsunfälle und werten diese regelmäßig aus.

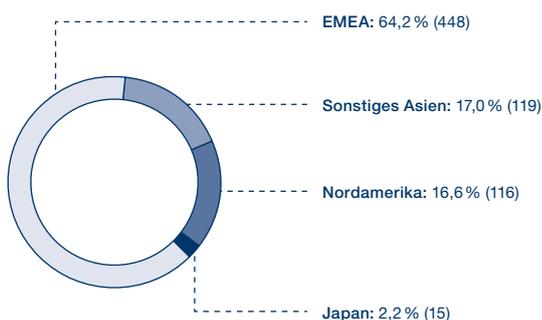
Im Geschäftsjahr 2015 wurde erstmalig ein kostenpflichtiger, mobiler Massageservice am Standort Garching getestet, welcher auf sehr positive Resonanz im Unternehmen gestoßen ist. Ab dem Geschäftsjahr 2016 wird dieser Service nun regelmäßig alle zwei Wochen für unsere Mitarbeiter zur Verfügung stehen.

Die Zusammenarbeit unserer Mitarbeiter weltweit sowie unser Umgang mit Kunden und Geschäftspartnern ist geprägt von gegenseitigem Respekt, integrem Handeln und der Einhaltung ethischer Richtlinien und Gesetze. Um die zahlreichen rechtlichen und ethischen Herausforderungen bei der täglichen Arbeit zu bewältigen, Orientierung zu schaffen und so das Vertrauen in die Leistung und Integrität der SÜSS MicroTec-Gruppe zu stärken, haben wir einen Verhaltenskodex (Code of Conduct) verabschiedet, dessen Einhaltung für alle Mitarbeiter weltweit verbindlich ist.

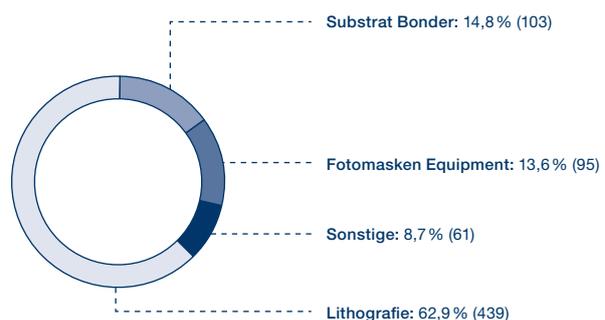
Durch das im Mai 2015 in Kraft getretene Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst (§ 76 Abs. 4 und § 111 Abs. 5 des AktG) sind bestimmte Gesellschaften verpflichtet, erstmals Zielgrößen für den Frauenanteil in Aufsichtsrat sowie den Vorstand und den nachfolgenden zwei Führungsebenen festzulegen. Darüber hinaus muss festgelegt werden, bis wann der jeweilige Frauenanteil erreicht werden soll.

Für die erste und zweite Führungsebene unterhalb des Vorstands hat der Vorstand der SÜSS MicroTec AG jeweils eine Zielgröße von 20% und eine Umsetzungsfrist bis zum 30. Juni 2017 beschlossen. Die Zielgröße für die erste Führungsebene

Mitarbeiter nach Regionen 2015



Mitarbeiter nach Segmenten 2015



bedeutet eine Steigerung des Frauenanteils, der derzeit bei 18 % liegt. Die Zielgröße für die zweite Führungsebene bedeutet ebenso eine Steigerung von derzeit 14 %. Die Umsetzungsfrist schöpft den zulässigen Rahmen für die erstmalige Festlegung der Umsetzungsfrist aus.

KUNDENBEZIEHUNGEN

Im Umgang mit Mitarbeitern, Kunden und Geschäftspartnern legen wir großen Wert auf die Einhaltung hoher ethischer Standards. Wir sind der Meinung, dass dies entscheidend zum Unternehmenserfolg beitragen kann. Dazu gehört der korrekte Umgang mit insiderrelevanten Informationen, mit dem geistigen Eigentum der Mitarbeiter und vertraulichen Informationen von Kunden und Lieferanten.

Zu unseren Kunden zählen unter anderem namhafte Integrated Device Manufacturers (IDM) in aller Welt und zahlreiche Kunden im Bereich Outsourced Assembly and Test (OSAT). Darüber hinaus arbeiten wir seit vielen Jahren mit führenden Universitäten und Forschungsinstituten im In- und Ausland sehr erfolgreich zusammen. Im Rahmen der Entwicklung von neuen und innovativen Technologien, Maschinen und Lösungen, gehen wir zudem Partnerschaften und Kooperationen mit anderen Industrieunternehmen ein.

Mitarbeiter nach Bereichen 2015



Übernahmerechtliche Angaben gemäß § 289 Abs. 4 HGB und § 315 Abs. 4 HGB

1. Zusammensetzung des gezeichneten Kapitals

Zum 31. Dezember 2015 belief sich das gezeichnete Kapital der Gesellschaft auf 19.115.538,00 € (Vorjahr: 19.115.538,00 €). Das Grundkapital ist in 19.115.538 (Vorjahr: 19.115.538) auf Namen lautende, nennwertlose Stückaktien unterteilt, auf die ein anteiliger Betrag von 1,00 € je Aktie entfällt. Die Aktien sind voll eingezahlt.

Mit allen Aktien sind die gleichen Rechte und Pflichten verbunden. Jede Aktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme und ist maßgebend für den Anteil der Aktionäre am Gewinn der Gesellschaft. Die Rechte und Pflichten der Aktionäre ergeben sich im Einzelnen aus den Regelungen des AktG, insbesondere aus den §§ 12, 53a ff., 118 ff. und 186 AktG.

Gemäß § 67 Abs. 2 AktG gilt im Verhältnis zur Gesellschaft als Aktionär nur, wer als solcher im Aktienregister eingetragen ist. Die Aktionäre haben der Gesellschaft die zur Führung des Aktienregisters erforderlichen Daten zu übermitteln.

2. Beschränkungen, die Stimmrechte oder die Übertragung von Aktien betreffen

Beschränkungen, die Stimmrechte oder die Übertragung von Aktien betreffen, bestehen nach der Satzung nicht. Wir haben auch keine Kenntnis von dem Bestehen derartiger Vereinbarungen zwischen Aktionären.

3. Beteiligungen am Kapital, die 10 % der Stimmrechte überschreiten

Direkte oder indirekte Beteiligungen am Kapital der Gesellschaft, die 10 % der Stimmrechte erreichen oder überschreiten, sind uns nicht gemeldet worden und auch nicht bekannt.

4. Aktien mit Sonderrechten, die Kontrollbefugnisse verleihen

Aktien mit Sonderrechten, die Kontrollbefugnisse verleihen, bestehen nicht.

5. Art der Stimmrechtskontrolle, wenn Arbeitnehmer am Kapital beteiligt sind und ihre Kontrollrechte nicht unmittelbar ausüben

Soweit die SÜSS MicroTec AG im Rahmen eines Mitarbeiteraktienprogramms Aktien an Mitarbeiter ausgibt, werden die Aktien den Mitarbeitern unmittelbar übertragen. Die begünstigten Mitarbeiter können die ihnen aus den Mitarbeiteraktien zustehenden Kontrollrechte wie andere Aktionäre unmittelbar nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften und der Bestimmungen der Satzung ausüben.

6. Gesetzliche Vorschriften und Bestimmungen der Satzung über die Ernennung und Abberufung von Vorstandsmitgliedern und die Änderung der Satzung

Die Bestellung und die Abberufung von Mitgliedern des Vorstands sind in den §§ 84 und 85 AktG geregelt. Danach werden Vorstandsmitglieder vom Aufsichtsrat auf höchstens fünf Jahre bestellt. Eine wiederholte Bestellung oder Verlängerung der Amtszeit, jeweils für höchstens fünf Jahre, ist zulässig. Über die Bestellung und Abberufung von Vorstandsmitgliedern beschließt der Aufsichtsrat mit der einfachen Mehrheit der Stimmen.

Der Vorstand besteht gemäß § 7 Abs. 1 der Satzung aus mindestens zwei Personen, wobei die Zahl der Vorstandsmitglieder vom Aufsichtsrat bestimmt wird. Der Aufsichtsrat kann gemäß § 84 AktG und § 7 Abs. 2 der Satzung einen Vorsitzenden bzw. Sprecher des Vorstands sowie einen stellvertretenden Vorsitzenden bzw. Sprecher ernennen.

Fehlt ein erforderliches Vorstandsmitglied, wird das Mitglied nach § 85 AktG in dringenden Fällen auf Antrag eines Beteiligten gerichtlich bestellt. Der Aufsichtsrat kann gemäß § 84 Abs. 3 AktG die Bestellung zum Vorstandsmitglied und die Ernennung zum Vorsitzenden des Vorstands widerrufen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt.

Eine Änderung der Satzung bedarf nach § 179 AktG eines Beschlusses der Hauptversammlung. Die Befugnis zu Änderungen, die nur die Fassung betreffen, ist gemäß § 17 Abs. 3 der Satzung dem Aufsichtsrat übertragen.

Satzungsändernde Beschlüsse der Hauptversammlung bedürfen nach §§ 133 und 179 AktG in Verbindung mit § 26 Abs. 1 der Satzung der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen und einer einfachen Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals, soweit nicht das Gesetz zwingend eine größere Mehrheit vorschreibt.

7. Befugnisse des Vorstands, Aktien auszugeben oder zurückzukaufen

Der Vorstand ist ermächtigt, in der Zeit bis zum 21. Juni 2016 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmal oder mehrfach um bis zu insgesamt 6.500.000,00 € durch Ausgabe von bis zu 6.500.000 neuen Stückaktien gegen Baranlagen zu erhöhen. Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit der Zustimmung des Aufsichtsrats und unter Einhaltung bestimmter Bedingungen das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen.

Weiterhin ist der Vorstand ermächtigt, in der Zeit bis zum 18. Juni 2018 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrfach um bis zu insgesamt 2.500.000,00 € durch Ausgabe von bis zu 2.500.000 neuen auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen. Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats und unter Einhaltung bestimmter Bedingungen das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen.

Der Vorstand ist darüber hinaus ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 18. Juni 2018 eigene Aktien der Gesellschaft bis zu insgesamt 10 % des bei der Beschlussfassung bestehenden Grundkapitals in Höhe von 19.115.538,00 € zu erwerben. Auf die erworbenen Aktien dürfen zusammen mit anderen eigenen Aktien, die sich im Besitz der Gesellschaft befinden oder ihr nach §§ 71 a ff. AktG zuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt mehr als 10 % des Grundkapitals entfallen. Die Ermächtigung darf nicht zum Zwecke des Handels in eigenen Aktien ausgeübt werden. Der Erwerb darf nach Wahl des Vorstands über die Börse oder mittels eines an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Kaufangebotes bzw. einer an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Aufforderung an die Aktionäre zur Abgabe eines Verkaufsangebotes erfolgen. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die aufgrund dieser Ermächtigung erworbenen eigenen Aktien zu allen gesetzlich zugelassenen Zwecken zu verwenden.

8. Wesentliche Vereinbarungen der Gesellschaft, die unter der Bindung eines Kontrollwechsels infolge eines Übernahmeangebots anstehen

Mit den Banken des Konsortiums bestehen unter einem gemeinsamen Sicherheitenpool jeweils bilaterale Kreditverhältnisse, die hinsichtlich ihrer Ausgestaltung bzw. Konditionen Unterschiede aufweisen. So enthält ein Kreditverhältnis ein außerordentliches Kündigungsrecht, falls eine Änderung der Gesellschaftsverhältnisse/ ein Change-of-Control eintritt und zwischen den Parteien keine rechtzeitige Einigung über die Fortsetzung zu gegebenenfalls veränderten Konditionen, z. B. hinsichtlich der Verzinsung, der Besicherung oder sonstiger Absprachen, erzielt wurde.

Sonstige wesentliche Vereinbarungen der SÜSS MicroTec AG, die unter der Bedingung eines Kontrollwechsels infolge eines Übernahmeangebots stehen, bestehen nicht.

9. Entschädigungsvereinbarung der Gesellschaft, die für den Fall eines Übernahmeangebots mit Vorstandsmitgliedern oder Arbeitnehmern getroffen sind

Entschädigungsvereinbarungen o. ä. mit Arbeitnehmern bzw. Mitgliedern des Vorstands für den Fall eines Übernahmeangebots existieren nicht.

Zusammenfassend bestehen keine besonderen Regelungen bezüglich der mit den Anteilen verbundenen Stimmrechte und hieraus resultierenden Kontrollmöglichkeiten, weder durch Einrichtung besonderer Aktiengattungen noch durch Stimmrechts- oder Übertragungsbeschränkungen. Über die gesetzlichen Regelungen hinausgehende Vorschriften über die Bestellung oder Abberufung von Mitgliedern des Vorstands sind nicht vorhanden. Wesentliche Geschäftsbereiche oder Aktivitäten der SÜSS MicroTec AG können im Fall eines Übernahmeangebots durch vorliegende Change-of-Control-Klauseln nicht wegfallen.

Erklärung zur Unternehmensführung gemäß § 289a HGB

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec AG haben mit Datum vom 3. März 2016 eine gemeinsame Erklärung zur Unternehmensführung nach § 289a HGB abgegeben und diese auf der Internetseite der Gesellschaft unter ► <http://ir.suss.com/websites/suess/German/2010/erklaerung-zur-unternehmens-fuehrung.html> allgemein zugänglich gemacht:

Erklärung zur Unternehmensführung

RELEVANTE ANGABEN ZUR UNTERNEHMENSFÜHRUNG NACH § 289A HGB

Die Erklärung zur Unternehmensführung nach § 289a HGB ist Bestandteil des zusammengefassten Lageberichts. Gemäß § 317 Abs. 2 Satz 4 HGB sind die Angaben nach § 289a Abs. 2 HGB nicht in die Prüfung einzubeziehen; insoweit ist im Rahmen der Prüfung lediglich festzustellen, ob diese Angaben gemacht wurden. Die Erklärung zur Unternehmensführung beinhaltet die Entsprechenserklärung, Angaben zu Unternehmensführungspraktiken und die Beschreibung der Arbeitsweise von Vorstand und Aufsichtsrat. Wir verfolgen dabei das Ziel, die Darstellung der Unternehmensführung übersichtlich und prägnant zu halten.

ENTSPRECHENSERKLÄRUNG UND BERICHT-ERSTATTUNG ZUR CORPORATE GOVERNANCE

Gem. § 161 AktG sind Vorstand und Aufsichtsrat einer börsennotierten deutschen Aktiengesellschaft verpflichtet, zumindest einmal jährlich zu erklären, ob dem Deutschen Corporate Governance-Kodex entsprochen wurde und wird oder welche Empfehlungen des Kodex nicht angewendet wurden oder werden und warum nicht. Auf Basis intensiver Beratungen haben Vorstand und Aufsichtsrat am 7. Januar 2016 erklärt, dass den Empfehlungen des Deutsche Corporate Governance-Kodex in der Fassung vom 5. Mai 2015 entsprochen wird mit den folgenden Ausnahmen – Selbstbehalt bei der D&O-Versicherung, vertikaler Vergütungsausgleich, Versorgungszusagen, Bildung von Ausschüssen und Festlegung einer Regelgrenze für die Zugehörigkeitsdauer im Aufsichtsrat.

Der Wortlaut der aktuellen Entsprechenserklärung sowie alle vorhergehenden Erklärungen zum Kodex sind auf der Website des Unternehmens unter ► www.suss.com ► **Investor Relations** ► **Corporate Governance** ► **Entsprechenserklärung** veröffentlicht.

COMPLIANCE

Als international tätiges Unternehmen ist SÜSS MicroTec darauf angewiesen, durch untadeliges Verhalten das Vertrauen der Kunden und Geschäftspartner zu gewinnen und zu erhalten. Die Einhaltung von Recht, Gesetz, unternehmensinternen Richtlinien und freiwillig eingegangenen Selbstverpflichtungen sowie deren Beachtung durch die Konzernunternehmen ist bei SÜSS MicroTec wesentliche Leitungsaufgabe.

Verhaltenskodex

Um ein einheitliches vorbildliches Handeln und Verhalten zu gewährleisten, wurde für den gesamten Konzern ein Verhaltenskodex (Code of Conduct) entwickelt, der für alle Mitarbeiter des Konzerns gleichermaßen Gültigkeit besitzt und der als Leitfaden dienen soll. Der Verhaltenskodex definiert Mindeststandards und beinhaltet Hinweise für die Mitarbeiter zum Umgang mit und der Bewältigung von ethischen und rechtlichen Herausforderungen, die im Rahmen der täglichen Arbeit auftreten können. Verstöße werden im Interesse aller Mitarbeiter und des Unternehmens konsequent verfolgt und deren Ursachen beseitigt.

Compliance-Handbuch

Das gruppenweite Compliance-Programm wird darüber hinaus durch das Compliance-Handbuch, diverse Prozessregelungen sowie die für die jeweiligen Organe gültige Geschäftsordnung ergänzt. Das Compliance-Handbuch richtet sich an alle Mitarbeiter des Konzerns mit dem Ziel, ein korrektes und einheitliches Verhalten im Umgang mit vertraulichen Unternehmensdaten sicherzustellen. Insbesondere werden darin die gesetzlich geltenden Bestimmungen des Verbots der Marktmanipulation sowie die Vorgaben des Insiderrechts erläutert. Personen, die für SÜSS MicroTec tätig sind und bestimmungsgemäß Zugang zu Insiderinformationen haben, um ihre Aufgaben bei SÜSS MicroTec wahrnehmen zu können, werden gemäß den Bestimmungen des Wertpapierhandelsgesetzes in ein Insiderverzeichnis aufgenommen. Diese Personen werden über die sich daraus ergebenden rechtlichen Pflichten sowie über die Rechtsfolgen von Verstößen aufgeklärt. Den gesetzlichen Regelungen zum Verbot von Insidergeschäften wird darüber hinaus im Rahmen einer ergänzenden Insiderrichtlinie Rechnung getragen, die den Handel mit Wertpapieren des Unternehmens für Organmitglieder und Mitarbeiter innerhalb definierter Zeitfenster regelt.

ARBEITSWEISE VON VORSTAND UND AUFSICHTSRAT

SÜSS MicroTec unterliegt als deutsche Aktiengesellschaft (AG) dem deutschen Aktienrecht und verfügt daher über eine zweigeteilte Führungs- und Kontrollstruktur, die von den Mitgliedern des Vorstands und den Mitgliedern des Aufsichtsrats wahrgenommen wird. Die Unternehmensführung der SÜSS MicroTec AG ist durch eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit von Vorstand und Aufsichtsrat bestimmt. Beide Organe arbeiten im Interesse des Unternehmens und mit dem gemeinsamen Ziel eng zusammen, den Unternehmenswert nachhaltig zu steigern. Für ihre Arbeit haben sich Vorstand und Aufsichtsrat jeweils eine Geschäftsordnung gegeben.

AUFSICHTSRAT

Der Aufsichtsrat überwacht und berät den Vorstand bei der Führung der Geschäfte und bestellt die Vorstandsmitglieder. In regelmäßigen Abständen erörtert der Aufsichtsrat die Geschäftsentwicklung und Planung sowie die Strategie und deren Umsetzung. Er behandelt die Quartals- und Halbjahresberichte und billigt den Jahresabschluss der SÜSS MicroTec AG und des Konzerns unter Berücksichtigung der Prüfungsberichte des Abschlussprüfers. Zu seinen Pflichten gehört auch die Überwachung der Einhaltung der Rechtsvorschriften, behördlichen Regelungen und der unternehmensinternen Richtlinien durch das Unternehmen (Compliance). Bedeutende Geschäftsvorgänge – wie beispielsweise Akquisitionen, Desinvestitionen und Finanzmaßnahmen – sind an seine Zustimmung gebunden. Der Aufsichtsratsvorsitzende koordiniert die Arbeit im Aufsichtsrat, leitet dessen Sitzungen und nimmt die Belange des Gremiums nach außen wahr. Der Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec AG ist nicht mitbestimmt.

Der Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec AG besteht gemäß Satzung aus drei Mitgliedern. Wie es der Deutsche Corporate Governance-Kodex empfiehlt, gehören dem Aufsichtsrat eine nach dessen Einschätzung angemessene Anzahl unabhängiger Mitglieder an. Insbesondere gehört mit Dr. Stefan Reineck nicht mehr als ein ehemaliges Vorstandsmitglied dem Aufsichtsrat an, womit eine unabhängige Beratung und Überwachung des Vorstands gewährleistet ist. Die Amtsperiode des Aufsichtsrats beträgt fünf Jahre. Die laufende Amtsperiode endet mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung im Jahr 2017.

Entgegen den Empfehlungen des Kodex sieht der Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec AG von der Bildung von Ausschüssen ab. Der Aufsichtsrat, der seit Juni 2008 aus drei Mitgliedern besteht, ist vielmehr der Ansicht, dass die Bildung von Ausschüssen, die Zusammenarbeit und Beschlussfindung unnötig erschweren würde.

VORSTAND

Der Vorstand der SÜSS MicroTec AG besteht derzeit aus drei Mitgliedern. Die Mitglieder des Vorstands tragen gemeinsam die Verantwortung für die Führung der Geschäfte und entscheiden über Grundsatzfragen der Geschäftspolitik sowie über die Jahres- und Mehrjahresplanung. Sie entwickeln die strategische Ausrichtung des Unternehmens, stimmen diese mit dem Aufsichtsrat ab und sorgen für deren Umsetzung. Der Vorstand informiert den Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend über die Geschäftspolitik sowie alle für das Unternehmen relevanten Fragen der Planung, der Geschäftsentwicklung, der Risikolage und des Risikomanagements sowie der Compliance.

Darüber hinaus ist der Vorstand zuständig für die Aufstellung der Quartals- und Halbjahresabschlüsse des Unternehmens, der Jahresabschlüsse der SÜSS MicroTec AG und der Konzernabschlüsse. Der Vorstand hat ferner für die Einhaltung von Rechtsvorschriften, behördlichen Regelungen und unternehmensinternen Richtlinien zu sorgen und wirkt auf deren Beachtung durch die Konzernunternehmen hin (Compliance).

VERGÜTUNG DES AUFSICHTSRATS UND DES VORSTANDS

Die SÜSS MicroTec AG entspricht den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance-Kodex, die Vergütung für den Vorstand und den Aufsichtsrat individualisiert offen zu legen. Die Grundbezüge der Vergütungs-Systeme und die Vergütungen sind im Vergütungsbericht, der Teil des zusammengefassten Lageberichts ist, dargestellt. Im Hinblick auf die vom Corporate Governance-Kodex angestrebte „vertikale Vergütungsstruktur“ erklärt SÜSS MicroTec AG insoweit vorsorglich eine Kodexabweichung, da der Aufsichtsrat der Auffassung ist, dass die Festlegung des obersten Führungskreises und der relevanten Belegschaft unter Einbeziehung der zeitlichen Entwicklung in der Praxis zu erheblichen Rechtsunsicherheiten führen kann.

AKTIENGESCHÄFTE DER ORGANMITGLIEDER (DIRECTORS' DEALINGS)

Personen, die bei der SÜSS MicroTec AG Führungsaufgaben wahrnehmen und damit insbesondere die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats sind nach § 15 a Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) gesetzlich verpflichtet, eigene Geschäfte mit Aktien der SÜSS MicroTec AG oder sich darauf beziehenden Finanzinstrumenten, insbesondere Derivaten, offenzulegen, soweit der Wert der von dem Mitglied und ihm nahestehenden Personen innerhalb eines Kalenderjahres getätigten Geschäfte die Summe von 5.000 € zum Ende des Kalenderjahres nicht erreicht.

Alle meldepflichtigen Wertpapiergeschäfte wurden entsprechend den gesetzlichen Regelungen veröffentlicht und sind auf der Website des Unternehmens frei einsehbar unter ► www.suss.com ► **Investor Relations** ► **Die Aktie** ► **Directors' Dealings**. Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats halten 0,16 % (31.100 Stimmrechte von 19.115.538 Stimmrechten) am Grundkapital der SÜSS MicroTec AG.

FESTLEGUNG VON ZIELGRÖSSEN ZUR FÖRDERUNG DER TEILHABE VON FRAUEN AN FÜHRUNGSPPOSITIONEN

Durch das am 1. Mai 2015 in Kraft getretene „Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst“ (§ 76 Abs. 4 und § 111 Abs. 5 des AktG) sind börsennotierte Gesellschaften wie die SÜSS MicroTec AG unter anderem verpflichtet worden, erstmals Zielgrößen für den Frauenanteil in Aufsichtsrat, Vorstand und den nachfolgenden zwei Führungsebenen festzulegen. Darüber hinaus musste festgelegt werden, bis wann die jeweilige Zielgröße erreicht werden soll.

In Umsetzung der vorgenannten Verpflichtung hat der Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec AG am 7. September 2015 für den Frauenanteil im Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec AG eine Zielgröße von 0 % beschlossen. Damit wird der aktuelle Stand festgehalten, so dass sich die Festlegung einer Frist zur Erreichung der vorgenannten Zielgröße erübrigte.

Der Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec AG hat am 7. September 2015 für den Frauenanteil im Vorstand der SÜSS MicroTec AG eine Zielgröße von 0 % beschlossen. Damit wird der aktuelle Stand festgehalten, so dass sich auch insoweit die Festlegung einer Frist zur Erreichung der vorgenannten Zielgröße erübrigte.

Für die erste und zweite Führungsebene unterhalb des Vorstands hat der Vorstand der SÜSS MicroTec AG am 2. September 2015 jeweils eine Zielgröße von 20 % und eine Umsetzungsfrist bis zum 30. Juni 2017 beschlossen. Die Zielgröße für die erste Führungsebene bedeutet eine Steigerung des Frauenanteils, der zum Zeitpunkt der Beschlussfassung bei 18 % lag. Die Zielgröße für die zweite Führungsebene bedeutet ebenso eine Steigerung, da der Frauenanteil zum Zeitpunkt der Beschlussfassung bei 14 % lag. Die Umsetzungsfrist schöpft den zulässigen Rahmen für die erstmalige Festlegung der Umsetzungsfrist aus. Zum 31. Dezember 2015 liegt der Frauenanteil im Rahmen der ersten Führungsebene weiterhin bei 18 %, der Frauenanteil im Rahmen der zweiten Führungsebene bei 14 %.

AKTIONÄRE UND HAUPTVERSAMMLUNG

Die Aktionäre der SÜSS MicroTec AG üben ihre Mitbestimmungs- und Kontrollrechte auf der mindestens einmal jährlich stattfindenden Hauptversammlung aus. Jede Aktie der SÜSS MicroTec gewährt eine Stimme. Sämtliche, für die Entscheidungsfindung notwendigen Unterlagen sind entsprechend den aktienrechtlichen Vorschriften auf der Website des Unternehmens veröffentlicht und können ebenfalls in Kopie beim Unternehmen angefordert werden.

Jeder Aktionär, der im Aktienregister eingetragen ist und sich rechtzeitig anmeldet, ist zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts berechtigt. Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen können, haben die Möglichkeit ihr Stimmrecht durch ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung, die von der Gesellschaft eingesetzten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter oder durch einen Bevollmächtigten ihrer Wahl ausüben zu lassen. Weisungen zur Stimmrechtsausübung können schriftlich im Vorfeld oder während der Hauptversammlung direkt vor Ort erteilt werden.

RECHNUNGSLEGUNG UND ABSCHLUSSPRÜFUNG

SÜSS MicroTec erstellt den Konzernabschluss sowie die Zwischenberichte nach den International Financial Reporting Standards (IFRS), wie sie in der Europäischen Union für börsennotierte Gesellschaften anzuwenden sind. Der Konzernabschluss wird vom Vorstand aufgestellt, vom Abschlussprüfer geprüft und vom Aufsichtsrat gebilligt. Der Einzelabschluss der SÜSS MicroTec AG wird nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) erstellt, vom Abschlussprüfer geprüft und vom Aufsichtsrat festgestellt.

Am 2. Juni 2015 bestellte die Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2015 die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Sitz in Hamburg, Zweigniederlassung München, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer der SÜSS MicroTec AG. Als Nachweis seiner Unabhängigkeit hat der Abschlussprüfer gegenüber dem Aufsichtsrat eine Unabhängigkeitserklärung abgegeben. Des Weiteren wurde mit dem Abschlussprüfer vereinbart, dass dieser den Aufsichtsrat über alle wesentlichen Feststellungen und Vorkommnisse informiert, die sich bei der Durchführung der Abschlussprüfung ergeben.

RISIKOMANAGEMENT

Der verantwortungsbewusste Umgang mit geschäftlichen Risiken gehört zu den Grundsätzen guter Corporate Governance. Zur Erkennung und Steuerung von Risiken sowie zur Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen ist ein Risikomanagement-System seit langem Bestandteil der Unternehmensführung bei SÜSS MicroTec. Dieses wird im Rahmen der Jahresabschlussprüfung jährlich geprüft.

Die Organisation des Risikomanagements orientiert sich an der funktionellen und hierarchischen Struktur des Konzerns. Mit der Einführung des Risikomanagement-Systems wurde ein Risikomanagement-Beauftragter ernannt, der alle drei Monate direkt an den Vorstand berichtet. Der Vorstand seinerseits informiert den Aufsichtsrat regelmäßig über bestehende Risiken und deren Entwicklung.

Einzelheiten zum Risikomanagement im SÜSS MicroTec-Konzern sind im Risikobericht, der Teil des Lageberichts ist, dargestellt. Hierin ist der Bericht zum rechnungslegungsbezogenen internen Kontroll- und Risikomanagement-System gemäß Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) enthalten.

TRANSPARENZ

Die SÜSS MicroTec informiert Aktionäre, Analysten, Aktionärsvereinigungen, Medien und die interessierte Öffentlichkeit regelmäßig und zeitnah über die aktuelle Geschäftsentwicklung und die Lage des Konzerns. Die verschiedenen Zielgruppen werden dabei gleichzeitig und gleichberechtigt behandelt. Alle kapitalmarktrelevanten Informationen sind zudem auf der Website des Unternehmens veröffentlicht und frei einsehbar. Die wesentlichen wiederkehrenden Termine und Ereignisse sind im Finanzkalender des Unternehmens zusammengestellt. Dieser wird mit ausreichend zeitlichem Vorlauf veröffentlicht und ist auf der Website des Unternehmens einsehbar unter ► www.suss.com ► [Investor Relations](#) ► [Finanzkalender](#).

Vergütungsbericht

Vergütung des Vorstands

SÜSS MicroTec legt die Vorstandsvergütung bereits seit mehreren Jahren individualisiert offen. Ziel des Systems der Vorstandsvergütung bei SÜSS MicroTec ist es, einen Anreiz für die langfristige und auf Nachhaltigkeit angelegte Unternehmensführung zu setzen. Besondere Leistungen sollen besonders vergütet werden. Aber auch Zielverfehlungen müssen zu einer spürbaren Verringerung der Vergütung führen; darüber hinaus muss sich die Vergütung an der Größe und der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens orientieren. Die Gesamtvergütung der Vorstandsmitglieder besteht aus erfolgsunabhängigen und erfolgsbezogenen Vergütungsbestandteilen.

Für die Festlegung der Vorstandsvergütung ist der Aufsichtsrat zuständig. Das Aufsichtsratsplenum beschließt und überprüft auf regelmäßiger Basis das Vergütungs-System für den Vorstand und beschließt über die Vorstandsverträge.

Der Aufsichtsrat hat sich eingehend mit der Ausrichtung der Vorstandsvergütung an einer nachhaltigen Unternehmensführung befasst. Hierzu wurde auch ein externer Vergütungsberater hinzugezogen.

FESTE VERGÜTUNG

Die Höhe der Festbezüge wird in erster Linie von der übertragenen Funktion bzw. der Verantwortung bestimmt. Die erfolgsunabhängigen Teile der Vergütung bestehen aus dem Grundgehalt sowie Nebenleistungen in Form eines Dienstwagens und Zuschüssen zur Krankenversicherung sowie zur freiwilligen Rentenversicherung. Darüber hinaus sind einzelnen Mitgliedern des Vorstands Versorgungszusagen (Alters-, Berufsunfähigkeits- und Witwenrente) in Form von Direktversicherungen (Kapitallebensversicherungen) gemacht worden.

ERFOLGSBEZOGENE VERGÜTUNG

Die erfolgsbezogene Vergütung besteht aus einer variablen Vergütung.

VARIABLE VERGÜTUNG

Die variable Vergütung kann seit dem 1. Januar 2012 höchstens 150 % der Festvergütung zu Beginn des betreffenden Geschäftsjahres betragen. Diese Regelung findet im Geschäftsjahr 2015 Anwendung für Herrn Knopp und Herrn Braun. Für Herrn Hansson kann die variable Vergütung höchstens 110 % der Festvergütung zu Beginn des betreffenden Geschäftsjahres

betragen. Diese Regelung gilt auch für künftige Geschäftsjahre. Mit Wirkung 1. Januar 2016 kann die variable Vergütung für Herrn Knopp und Herrn Braun höchstens 100 % der Festvergütung zu Beginn des betreffenden Geschäftsjahres betragen.

70 % der variablen Vergütung bestimmen sich nach Jahreszielen und 30 % nach Mehrjahreszielen. Da Herr Hansson für das Geschäftsjahr 2015 eine garantierte Tantieme erhält, wurden für ihn keine Jahresziele bzw. Mehrjahresziele vereinbart.

AN JAHRESZIELEN ORIENTIERTE VARIABLE VERGÜTUNG (VARIABLE VERGÜTUNG A)

Die Jahresziele (Auftragsengang, Umsatz, EBITDA und Free Cashflow) werden für jeweils ein Geschäftsjahr vom Aufsichtsrat festgelegt. Werden diese Ziele zu 70 % oder weniger erreicht, entfällt diese Vergütungskomponente. Bei einer Zielerreichung von 130 % ist der Maximalbetrag erreicht. Beträgt der Zielerreichungsgrad für ein bestimmtes Ziel zwischen 70 % und 130 %, ist der entsprechende anteilige Betrag an der variablen Vergütung im Verhältnis zum Zielerreichungsgrad zu ermitteln.

Die an Jahreszielen orientierte Vergütung wird jährlich ermittelt. Im Interesse einer Förderung der langfristigen Unternehmensentwicklung steht den Vorstandsmitgliedern aber nur die Hälfte der variablen Vergütung A endgültig zu. In Bezug auf die andere Hälfte des Auszahlungsbetrages (Vorbehaltshälfte) ist das Vorstandsmitglied verpflichtet, in dem ersten Handelsfenster nach Auszahlung des Auszahlungsbetrages Aktien der Gesellschaft zu erwerben und für eine Sperrfrist von drei Jahren, gerechnet ab dem letzten Tag des Handelsfensters, in dem die Aktien erworben wurden, in einem auf seinen Namen lautenden Depot zu halten.

AN MEHRJAHRESZIELEN ORIENTIERTE VARIABLE VERGÜTUNG (VARIABLE VERGÜTUNG B)

30 % der variablen Vergütung entfallen auf mehrjährige Ziele, die für einen Zeitraum von regelmäßig drei Geschäftsjahren festgelegt werden.

Erstmals erfolgte eine Festlegung der Mehrjahresziele für die Geschäftsjahre 2010 bis 2012. Für die Geschäftsjahre 2013 bis 2015 erfolgte die erneute Festlegung von Mehrjahreszielen für drei Geschäftsjahre im Voraus, wobei diese sich nach Funktion und Aufgabenbereich des Vorstandsmitglieds unterscheiden können. Die derzeitigen Mehrjahresziele beziehen sich auf die Erreichung festgelegter EBIT-Margen bzw. Meilensteine

von Entwicklungsprojekten in definierten Zeiträumen. Werden diese Ziele zu 70 % oder weniger erreicht, entfällt diese Vergütungskomponente. Bei einer Zielerreichung von 150 % ist der Maximalbetrag erreicht. Beträgt der Zielerreichungsgrad für ein bestimmtes Ziel zwischen 70 % und 150 %, ist der entsprechende anteilige Betrag an der variablen Vergütung im Verhältnis zum Zielerreichungsgrad zu ermitteln. Die an Mehrjahreszielen orientierte variable Vergütung B wird jährlich ermittelt und für das jeweilige Geschäftsjahr vollständig ausgezahlt.

ABFINDUNGEN

In Vorstandsverträgen ist für den Fall, dass die Vorstandstätigkeit ohne wichtigen Grund vorzeitig endet, eine Ausgleichszahlung vorgesehen. Diese ist auf maximal zwei Jahresvergütungen einschließlich Nebenleistungen begrenzt (Abfindungs-Cap) und vergütet nicht mehr als die Restlaufzeit des jeweiligen Anstellungsvertrages. Eine Zusage für Leistungen aus Anlass der vorzeitigen Beendigung der Vorstandstätigkeit infolge eines Kontrollwechsels (Change-of-Control-Regelung) ist in den bestehenden Vorstandsverträgen nicht enthalten.

VORSTANDSVERGÜTUNG

Die im Folgenden aufgeführten Tabellen zur Vorstandsvergütung entsprechen dem Deutschen Corporate Governance-Kodex. Die Festvergütung und die Nebenleistungen richten sich nach dem vereinbarten Festbetrag. Für die variable Vergütung ist sowohl ein Zielwert für eine Erreichung von 100 % angegeben als auch die erreichbare Minimal- und Maximalvergütung.

Für die Geschäftsjahre 2014 und 2015 beträgt die Tantieme von Herrn Braun jeweils mindestens 35.625,00 €. Für das Geschäftsjahr 2015 erhält Herr Hansson eine garantierte Tantieme von 186.667,00 €.

HÖHE DER VORSTANDSVERGÜTUNG

Die folgenden Tabellen („Gewährte Zuwendungen“ und „Zufluss“) zeigen die Vergütung für die Geschäftsjahre 2015 und 2014 je Vorstandsmitglied gemäß den Anforderungen des Deutschen Corporate Governance-Kodex Ziffer 4.2.5 Abs. 3. Die Angaben, die bisher gemäß § 314 HGB in der Tabelle „Vorstandsvergütung“ enthalten waren, sind nun in der Tabelle „Zufluss“ abgebildet.

Zielvergütung des Vorstands nach dem Deutschen Corporate Governance-Kodex:

in €	Dr. Per-Ove Hansson			
	Vorstandsvorsitzender CEO, Eintritt 01.05.2015			
Gewährte Zuwendungen	2014	2015 (100 %)	2015 (Min)	2015 (Max)
Festvergütung	–	233.336,00	233.336,00	233.336,00
Wechselprämie ¹	–	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Nebenleistungen (fix) ²	–	44.850,10	44.850,10	44.850,10
Aufwand für Altersversorgung ³	–	–	–	–
Summe	–	378.186,10	378.186,10	378.186,10
Einjährige variable Vergütung (A) ⁴	–	130.666,90	130.666,90	130.666,90
davon Investition in SÜSS MicroTec-Aktien ⁵	–	65.333,45	65.333,45	65.333,45
Mehrjährige variable Vergütung (B) (2013–2015)	–	56.000,10	56.000,10	56.000,10
Summe	–	564.853,10	564.853,10	564.853,10
Versorgungsaufwand	–	–	–	–
Gesamtvergütung	–	564.853,10	564.853,10	564.853,10

¹ Die Wechselprämie von 200.000 € kommt in zwei Tranchen zur Auszahlung im Mai 2015 und im Mai 2016.

² enthält: Zuschuss freiwillige Rentenversicherung
Geldwerter Vorteil Pkw
Unternehmensanteil gesetzliche oder private Krankenkasse
Zuschuss Umzug und Mehrkosten Wohnung (befristet auf sechs Monate)

³ Aufwand für Altersversorgung (Direktversicherung)

⁴ Variable Vergütung (einjährig und mehrjährig) maximal 150 % der Festvergütung des betreffenden Geschäftsjahres

⁵ Für die im Rahmen der variablen Vergütung erworbenen Aktien gilt eine Sperrfrist von drei Jahren.

Michael Knopp
Finanzvorstand CFO

in €

Gewährte Zuwendungen	2014	2015 (100 %)	2015 (Min)	2015 (Max)
Festvergütung	251.254,00	268.339,00	268.339,00	268.339,00
Wechselprämie ¹	–	–	–	–
Nebenleistungen (fix) ²	21.502,56	21.646,08	21.646,08	21.646,08
Aufwand für Altersversorgung ³	2.148,00	2.148,00	2.148,00	2.148,00
Summe	274.904,56	292.133,08	292.133,08	292.133,08
Einjährige variable Vergütung (A) ⁴	128.625,00	136.500,00	–	273.000,00
davon Investition in SÜSS MicroTec-Aktien ⁵	64.312,50	68.250,00	–	136.500,00
Mehrfährige variable Vergütung (B) (2013–2015)	55.125,00	58.500,00	–	117.000,00
Summe	458.654,56	487.133,08	292.133,08	682.133,08
Versorgungsaufwand	–	–	–	–
Gesamtvergütung	458.654,56	487.133,08	292.133,08	682.133,08

¹ Die Wechselprämie von 200.000 € kommt in zwei Tranchen zur Auszahlung im Mai 2015 und im Mai 2016.

² enthält: Zuschuss freiwillige Rentenversicherung
Geldwerter Vorteil Pkw
Unternehmensanteil gesetzliche oder private Krankenkasse
Zuschuss Umzug und Mehrkosten Wohnung (befristet auf sechs Monate)

³ Aufwand für Altersversorgung (Direktversicherung)

⁴ Variable Vergütung (einjährig und mehrjährig) maximal 150 % der Festvergütung des betreffenden Geschäftsjahres

⁵ Für die im Rahmen der variablen Vergütung erworbenen Aktien gilt eine Sperrfrist von drei Jahren.

Walter Braun
Produktionsvorstand COO, Eintritt: 01.07.2014

in €

Gewährte Zuwendungen	2014	2015 (100 %)	2015 (Min)	2015 (Max)
Festvergütung	94.998,00	189.996,00	189.996,00	189.996,00
Wechselprämie ¹	–	–	–	–
Nebenleistungen (fix) ²	9.993,66	20.093,88	20.093,88	20.093,88
Aufwand für Altersversorgung ³	–	–	–	–
Summe	104.991,66	210.089,88	210.089,88	210.089,88
Einjährige variable Vergütung (A) ⁴	49.875,00	99.750,00	35.625,00	199.500,00
davon Investition in SÜSS MicroTec-Aktien ⁵	24.937,50	49.875,00	17.812,50	99.750,00
Mehrfährige variable Vergütung (B) (2013–2015)	21.375,00	42.750,00	–	85.500,00
Summe	176.241,66	352.589,88	245.714,88	495.089,88
Versorgungsaufwand	–	–	–	–
Gesamtvergütung	176.241,66	352.589,88	245.714,88	495.089,88

¹ Die Wechselprämie von 200.000 € kommt in zwei Tranchen zur Auszahlung im Mai 2015 und im Mai 2016.

² enthält: Zuschuss freiwillige Rentenversicherung
Geldwerter Vorteil Pkw
Unternehmensanteil gesetzliche oder private Krankenkasse
Zuschuss Umzug und Mehrkosten Wohnung (befristet auf sechs Monate)

³ Aufwand für Altersversorgung (Direktversicherung)

⁴ Variable Vergütung (einjährig und mehrjährig) maximal 150 % der Festvergütung des betreffenden Geschäftsjahres

⁵ Für die im Rahmen der variablen Vergütung erworbenen Aktien gilt eine Sperrfrist von drei Jahren.

Frank Averdung

Vorstandsvorsitzender CEO, Austritt: 24.08.2014

in €

Gewährte Zuwendungen	2014	2015 (100 %)	2015 (Min)	2015 (Max)
Festvergütung	330.000,00	–	–	–
Wechselprämie ¹	–	–	–	–
Nebenleistungen (fix) ²	23.789,28	–	–	–
Aufwand für Altersversorgung ³	2.148,00	–	–	–
Summe	355.937,28	–	–	–
Einjährige variable Vergütung (A) ⁴	173.250,00	–	–	–
davon Investition in SÜSS MicroTec-Aktien ⁵	86.625,00	–	–	–
Mehrjährige variable Vergütung (B) (2013–2015)	74.250,00	–	–	–
Summe	603.437,28	–	–	–
Versorgungsaufwand	–	–	–	–
Gesamtvergütung	603.437,28	–	–	–

¹ Die Wechselprämie von 200.000 € kommt in zwei Tranchen zur Auszahlung im Mai 2015 und im Mai 2016.

² enthält: Zuschuss freiwillige Rentenversicherung
Geldwerter Vorteil Pkw
Unternehmensanteil gesetzliche oder private Krankenkasse
Zuschuss Umzug und Mehrkosten Wohnung (befristet auf sechs Monate)

³ Aufwand für Altersversorgung (Direktversicherung)

⁴ Variable Vergütung (einjährig und mehrjährig) maximal 150 % der Festvergütung des betreffenden Geschäftsjahres

⁵ Für die im Rahmen der variablen Vergütung erworbenen Aktien gilt eine Sperrfrist von drei Jahren.

Zufluss der Vorstandsvergütung nach dem Deutschen Corporate Governance-Kodex:

Dr. Per-Ove Hansson
Vorstandsvorsitzender CEO,
Eintritt 01.05.2015

Michael Knopp
Finanzvorstand CFO

in €

Zufluss	2014	2015	2014	2015
Festvergütung	–	233.336,00	251.254,00	268.339,00
Wechselprämie ¹	–	100.000,00	–	–
Nebenleistungen (fix) ²	–	44.850,10	21.502,56	21.646,08
Aufwand für Altersversorgung ³	–	–	2.148,00	2.148,00
Abfindungszahlungen	–	–	–	–
Summe	–	378.186,10	274.904,56	292.133,08
Einjährige variable Vergütung (A) ⁴	–	130.666,90	191.758,96	252.429,75
davon Investition in SÜSS MicroTec-Aktien ⁵	–	65.333,45	95.879,48	126.214,87
Mehrjährige variable Vergütung (B) (2013–2015)	–	56.000,10	104.107,89	–
Summe	–	564.853,10	570.771,41	544.562,83
Versorgungsaufwand	–	–	–	–
Gesamtvergütung	–	564.853,10	570.771,41	544.562,83

¹ Die Wechselprämie von 200.000 € kommt in zwei Tranchen zur Auszahlung im Mai 2015 und im Mai 2016.

² enthält: Zuschuss freiwillige Rentenversicherung
Geldwerter Vorteil Pkw
Unternehmensanteil gesetzliche oder private Krankenkasse
Zuschuss Umzug und Mehrkosten Wohnung (befristet auf sechs Monate)

³ Aufwand für Altersversorgung (Direktversicherung)

⁴ Variable Vergütung (einjährig und mehrjährig) maximal 150 % der Festvergütung des betreffenden Geschäftsjahres

⁵ Für die im Rahmen der variablen Vergütung erworbenen Aktien gilt eine Sperrfrist von drei Jahren.

in €	Walter Braun Produktionsvorstand COO, Eintritt: 01.07.2014		Frank Averdung Vorstandsvorsitzender CEO, Austritt: 24.08.2014	
	2014	2015	2014	2015
Zufluss				
Festvergütung	94.998,00	189.996,00	330.000,00	–
Wechselprämie ¹	–	–	–	–
Nebenleistungen (fix) ²	9.993,66	20.093,88	23.789,28	–
Aufwand für Altersversorgung ³	–	–	2.148,00	–
Abfindungszahlungen	–	–	930.000,00	–
Summe	104.991,66	210.089,88	1.285.937,28	–
Einjährige variable Vergütung (A) ⁴	74.355,51	184.467,89	120.000,00	–
davon Investition in SÜSS MicroTec-Aktien ⁵	37.177,76	92.233,95	–	–
Mehrjährige variable Vergütung (B) (2013–2015)	16.648,99	64.125,00	–	–
Summe	195.996,16	458.682,77	1.405.937,28	–
Versorgungsaufwand	–	–	–	–
Gesamtvergütung	195.996,16	458.682,77	1.405.937,28	–

¹ Die Wechselprämie von 200.000 € kommt in zwei Tranchen zur Auszahlung im Mai 2015 und im Mai 2016.

² enthält: Zuschuss freiwillige Rentenversicherung
Geldwerter Vorteil Pkw
Unternehmensanteil gesetzliche oder private Krankenkasse
Zuschuss Umzug und Mehrkosten Wohnung (befristet auf sechs Monate)

³ Aufwand für Altersversorgung (Direktversicherung)

⁴ Variable Vergütung (einjährig und mehrjährig) maximal 150 % der Festvergütung des betreffenden Geschäftsjahres

⁵ Für die im Rahmen der variablen Vergütung erworbenen Aktien gilt eine Sperrfrist von drei Jahren.

PENSIONEN

Es bestehen keine Pensionsrückstellungen für Mitglieder oder ehemalige Mitglieder des Vorstands.

Vergütung des Aufsichtsrats

Die Vergütung des Aufsichtsrats ist in § 19 der Satzung der SÜSS MicroTec AG geregelt. Neben der Erstattung ihrer Auslagen und einem Sitzungsgeld von 2.000,00€ pro Sitzung erhält jedes Aufsichtsratsmitglied eine feste Vergütung, die sich an der Verantwortung und dem Tätigkeitsumfang der Aufsichtsratsmitglieder orientiert. Demnach erhält der Vorsitzende des Aufsichtsrats 60.000,00€, sein Stellvertreter 50.000,00€ und ein einfaches Mitglied des Aufsichtsrats 45.000,00€ pro Geschäftsjahr als feste Vergütung. Die Mitglieder des Aufsichtsrats haben der Gesellschaft den rechnerischen Pro-Kopf-Anteil der von der Gesellschaft gezahlten D&O-Versicherungsprämie erstattet.

2015 in €	Vergütung	Sitzungsgeld	Abzug für anteilige D&O-Versicherungsprämie
Aufsichtsrat			
Dr. Stefan Reineck (Aufsichtsratsvorsitzender)	60.000,00	12.000,00	1.655,18
Jan Teichert (Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender)	50.000,00	12.000,00	827,59
Gerhard Pegam	45.000,00	12.000,00	551,73

2014 in €	Vergütung	Sitzungsgeld	Abzug für anteilige D&O-Versicherungsprämie
Aufsichtsrat			
Dr. Stefan Reineck (Aufsichtsratsvorsitzender)	45.000,00	13.500,00	1.914,82
Jan Teichert (Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender)	40.000,00	13.500,00	957,41
Gerhard Pegam	35.000,00	12.000,00	638,27

Im Geschäftsjahr 2015 haben weder die Mitglieder des Aufsichtsrats noch ihnen nahestehende Personen oder Unternehmen eine Vergütung bzw. Vorteile für persönlich erbrachte Leistungen, insbesondere Beratungs- und Vermittlungsleistungen, erhalten.

Nachtragsbericht

Bericht zu wesentlichen Ereignissen nach Ende des Geschäftsjahres

Wesentliche Ereignisse nach dem Stichtag, die einen signifikanten Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- oder Ertragslage des Konzerns haben, haben sich nicht ergeben.

Die Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main, Deutschland, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 28. Januar 2016 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 25. Januar 2016

die Schwelle von 5 % unterschritten hat und zu diesem Tag 4,86 % beträgt (929.356 Stimmrechte). Davon sind ihr 4,86 % (929.356 Stimmrechte) nach § 22 WpHG zuzurechnen.

Die Dimensional Holdings Inc., Austin, Texas, USA, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 3. März 2016 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 25. Februar 2016 die Schwelle von 3 % überschritten hat und zu diesem Tag 3,004 % beträgt (574.300 Stimmrechte). Davon sind ihr 3,004 % (574.300 Stimmrechte) nach § 22 WpHG zuzurechnen.

Potenziale

Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung des SÜSS MicroTec-Konzerns

Unser Chancen- und Risikomanagement zielt darauf ab, den Unternehmenswert des SÜSS MicroTec-Konzerns nachhaltig zu sichern und zu steigern. Zu unserer unternehmerischen Zielsetzung gehören das frühzeitige und erfolgreiche Erkennen von Chancen sowie die Identifikation und angemessene Bewertung der damit verbundenen Risiken und die adäquate Reaktion darauf. Die vielfältigen Chancen für unseren Konzern resultieren aus der Technologieführerschaft in unseren Geschäftsfeldern, unserem breiten Spektrum an Produkten und Lösungen für die Halbleiter-Equipment-Industrie, den Kooperationen mit internationalen Kunden und Forschungsinstituten sowie unserer globalen Ausrichtung.

Chancen und Risiken definieren wir wie folgt:

- Chancen sind mögliche künftige Entwicklungen oder Ereignisse, die zu einer für den Konzern positiven Prognose- bzw. Zielabweichung führen können.
- Unter Risiken verstehen wir mögliche künftige Entwicklungen oder Ereignisse, die zu einer für den Konzern negativen Prognose- bzw. Zielabweichung führen können.

Die Analyse und Beurteilung der Chancen und Risiken des Konzerns ist Gegenstand fortlaufender Betrachtungen durch den Vorstand und das Management des Konzerns. Auf der Grundlage eines chancenorientierten, gleichzeitig aber risikobewussten Managements ist es jedoch nicht unser Ziel, alle potenziellen Risiken grundsätzlich zu vermeiden. Vielmehr streben wir stets ein Optimum aus Risikovermeidung, -reduzierung und kontrollierter Risikoakzeptanz an. Das Bewusstsein für Risiken sollte nicht die Fähigkeit beeinträchtigen, Chancen zu erkennen und zum Wohle des Unternehmens und seiner Aktionäre zu nutzen.

CHANCEN DES KONZERNS

Die globale Geschäftstätigkeit des SÜSS MicroTec-Konzerns innerhalb eines dynamischen Marktumfelds eröffnet ständig neue Chancen, die das angestrebte Wachstum von SÜSS MicroTec unterstützen und vorantreiben können. Das Erkennen und Nutzen dieser Chancen gehört daher zu den wesentlichen Bestandteilen unserer Wachstumspolitik.

Gesamtwirtschaftliche Chancen

SÜSS MicroTec ist mit Produktions-, Verkaufs- und Service-Niederlassungen weltweit vertreten und arbeitet darüber hinaus mit vielen externen Handelspartnern zusammen. Durch die internationale Präsenz bieten sich dem Konzern zahlreiche Chancen, weltweit neue Kunden zu akquirieren, neue Kooperationen einzugehen und an dem Wachstum der Industriemärkte in den bedeutenden und aufstrebenden Volkswirtschaften teilzuhaben.

Unternehmensstrategische Chancen

SÜSS MicroTec hat in der Herstellung von Prozessausrüstungen für die Halbleiter-Industrie Standards in Präzision und Qualität gesetzt. Kontinuierliche Innovationsleistungen und die Fähigkeit, stets neue Lösungen in einem sich schnell ändernden Umfeld bereit zu stellen, haben SÜSS MicroTec zum Technologieführer gemacht. Diese Stärken zusammen mit einer soliden finanziellen Ausstattung geben dem Konzern die Möglichkeit, aussichtsreiche Entwicklungsprojekte durchzuführen, erfolgsversprechende Kooperationen einzugehen und damit die Produktpalette weiter auszubauen sowie Anwendungen und Technologien weiterzuentwickeln. Der SÜSS MicroTec-Konzern pflegt zahlreiche Entwicklungspartnerschaften mit Forschungsinstituten und Universitäten. Insbesondere die Zusammenarbeit mit Forschungsinstituten bietet großes Potenzial für SÜSS MicroTec, denn diese arbeiten in der Regel sehr eng mit unseren Kunden zusammen und werden zu einem nicht unerheblichen Anteil durch die Kunden finanziert. Neue Basistechnologien werden häufig in den Laboren der Forschungsinstitute entwickelt und finden dann erst ihren Weg in die Industrie. Umso wichtiger ist es für ein Hightech-Unternehmen wie SÜSS MicroTec, von Anfang an in die Neuentwicklung von Technologien und Prozessen mit eingebunden zu sein. Dies erhöht die Chancen, später Maschinen und Lösungen für das industrielle Umfeld in der Volumenproduktion liefern zu können.

Neben der Weiterentwicklung eigener Technologien sieht SÜSS MicroTec grundsätzlich auch die Chance, den Konzern durch Akquisition von außen um neue Geschäftsfelder und Technologien zu erweitern.

Branchen- und marktspezifische Chancen

Die von SÜSS MicroTec bedienten Märkte der Halbleiter-Equipment-Industrie unterliegen einem stetigen Wandel, der vor allem durch die rasanten Entwicklungen im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie beeinflusst wird. So ist die weltweit immer weiter steigende Anzahl von Smartphones und Tablet-Computern ein wesentlicher Wachstumstreiber für die Hersteller dieser Produkte. 2015 wurden in Deutschland 26,2 Millionen Smartphones verkauft, das ist ein Plus von 7,4 % gegenüber dem Vorjahr. Der Umsatz in Deutschland stieg sogar um 22 % auf 10,3 Mrd. € und knackte damit erstmals die symbolische Marke von 10 Mrd. €. Das berichtet der Digitalverband Bitkom auf Grundlage aktueller Prognosen des European Information Technology Observatory (EITO)¹. Der Smartphone-Boom

wird Bitkom-Prognosen zufolge auch 2016 weitergehen. Für Deutschland wird ein Absatz von voraussichtlich 28,2 Millionen Geräten erwartet, das wäre ein erneutes Plus von 7,5 % gegenüber 2015.

Auch das weltweite Wachstum ist ungebrochen. So wurden im vierten Quartal 2014 weltweit erstmals mehr als 300 Millionen Smartphones verkauft. In den ersten drei Quartalen 2015 setzte sich dieser Wachstumstrend fort – in allen drei Quartalen lag der Smartphone-Absatz jeweils deutlich über der 300-Millionen-Marke².

Darüber hinaus sorgt auch die technische Weiterentwicklung der Geräte für steigenden Absatz. Nach einer Umfrage, die im Auftrag des Digitalverbands Bitkom durchgeführt wurde, wünschen sich Smartphone-User für ihre Geräte vor allem eine längere Akkulaufzeit (63 % der Befragten), eine Fotokamera mit besserer Qualität (36 %) sowie mehr Speicherkapazität (35 %) und mehr Rechnerleistung (23 %)³. Weitere technische Features, die immer mehr Smartphones aufweisen, sind zum Beispiel ein geschwungener oder biegsamer Bildschirm, ein Fingerabdruck-Sensor oder 3D-Fähigkeit der Kamera. Die Smartphone-Verkäufe 2015 haben gezeigt, dass die Verbraucher bereit sind, in Leistung und Komfort zu investieren. So lag der Durchschnittspreis eines Smartphones 2015 in Deutschland bei 395 €, während im Jahr zuvor durchschnittlich nur 348 € für ein Smartphone ausgegeben wurden.

Die zunehmende Nachfrage nach Smartphones mit komplexen Bauteilen fördert den Umsatz von SÜSS MicroTec bei mehreren Produkten. Unsere Mask Aligner, Belacker und Bonder werden von unseren Kunden eingesetzt, um Chips mit Strukturen zu versehen und um zahlreiche Sensoren, die in jedem Smartphone enthalten sind, herzustellen. Außerdem unterstützt SÜSS MicroTec mit dem UV-Bonden zwei wichtige Prozessschritte, die bei der Herstellung von Optiken auf Wafer-Ebene (Wafer-Level-Optics – WLO) notwendig sind. Nahezu alle Kameras, die in Mobiltelefonen und anderen mobilen Geräten eingebaut sind, bestehen neben dem CMOS-Bildsensor aus einer Optik auf Wafer-Ebene.

Wesentliche Bereiche der globalen Halbleiter-Branche sind auf Asien fokussiert. Dazu gehören einige große Packaging-Häuser (OSATs) sowie viele der weltweit agierenden Hersteller von Speichermedien und MEMS-Bauteilen.

¹ Quelle: Presseinformation des Digitalverbands Bitkom vom 16. Februar 2016

² Quelle: Statista 2016

³ Quelle: Presseinformation des Digitalverbands Bitkom vom 22. Februar 2016

Die starken Marktzyklen der Halbleiter-Industrie bieten SÜSS MicroTec – je nach Art der Entwicklung – zahlreiche neue Chancen im Markt, die kurzfristig für einen starken Anstieg der Auftragseingänge und der Umsätze sorgen können.

Unser globales Netzwerk von Vertriebsmitarbeitern, Produkt-ingenieuren und Handelspartnern ist darauf ausgerichtet, die branchen- und marktspezifischen Anforderungen unserer Kunden weltweit zu erfüllen. SÜSS MicroTec ist in den Kernmärkten der Halbleiter-Equipment-Industrie in Taiwan, China, Japan und Südkorea mit eigenen Tochtergesellschaften vertreten. Unsere Niederlassungen pflegen stets den direkten Kontakt mit unseren Kunden und haben damit die Möglichkeit, aktuelle Entwicklungen auf den Halbleiter-Märkten umgehend zu registrieren. Damit kann SÜSS MicroTec rasch auf sich abzeichnende Neuentwicklungen reagieren und seine Anwendungen entsprechend anpassen.

Um neue Entwicklungen am Markt immer schnell wahrzunehmen, ist uns der direkte und regelmäßige Kontakt zu Kooperationspartnern, Kunden und potenziellen Neukunden sehr wichtig. SÜSS MicroTec ist daher auf Messen für die Halbleiter-Industrie vertreten und veranstaltet internationale Technologie-Foren. So präsentiert SÜSS MicroTec seine Neuentwicklungen regelmäßig auf den Semicon-Messen, die jährlich an verschiedenen Standorten weltweit stattfinden. Daneben präsentiert SÜSS MicroTec seine Entwicklungen auch auf kleineren, lokalen Messen. So fand zum Beispiel im März 2015 parallel zur Semicon China das SÜSS Technology Forum statt, auf dem unseren Kunden in Zusammenarbeit mit verschiedenen Forschungsinstituten Neuheiten präsentiert wurden. In Monterey (Kalifornien, USA) organisierte SÜSS MicroTec zum zweiten Mal das SÜSS Photomask Summit, an dem Manager und Technologen von führenden Masken-Shops, Device-Fabrikanten, Material- und Geräteherstellern sowie wissenschaftlichen Konsortien teilnahmen.

Durch die enge Zusammenarbeit mit SEMI und zahlreichen internationalen Forschungsinstituten kann SÜSS MicroTec einen großen Adressatenkreis ansprechen. Die internationale Präsenz von SÜSS MicroTec und der durch die Messen und Veranstaltungen hohe Bekanntheitsgrad geben uns die Möglichkeit, das Ohr immer direkt am Markt zu haben und auf technologische Fortschritte und Neuentwicklungen schnell zu reagieren.

Operative Chancen

Die Lithografie ist nach wie vor der größte Umsatzbringer der SÜSS MicroTec-Gruppe und sorgt jährlich für etwa zwei Drittel des gesamten Konzernumsatzes. Mit den Produktlinien Mask Aligner und Belacker/Entwickler ist SÜSS MicroTec seit vielen Jahren erfolgreich am Markt vertreten und bedient damit Kunden aus verschiedenen Branchen und Märkten. Das konstante Umsatzvolumen und die relativ stabilen Margen dieser beiden

Produktlinien sichern dem SÜSS MicroTec-Konzern eine gleichmäßige Auslastung der Produktionsstandorte Garching und Sternenfels und beständige positive Cashflows. Mit Weiterentwicklungen und Verbesserungen der Technologien dieser beiden Produktlinien festigen wir unsere Marktposition und stellen sicher, dass mit Mask Alignern und Belackern/Entwicklern auch zukünftig stabile Margen und Cashflows erzielt werden können.

Mit den durch die Akquisition der SÜSS MicroTec Photonic Systems hinzugewonnenen Technologien – der UV-Projektionsbelichtung und der Laserprozessierung – haben wir unser Produktportfolio im Bereich Lithografie ergänzt und erweitert. Im Jahr 2015 konnten wir einen Großauftrag eines führenden Herstellers der Halbleiter-Industrie über eine nennenswerte Stückzahl von Projektionsscannern des Typs DSC300 Gen2 verbuchen. Die Geräte sind für die Serienfertigung im Wachstumssegment Fan-out Wafer-Level Packaging vorgesehen. Die DSC300 Gen2 bietet vergleichbare Fähigkeiten im Hinblick auf Auflösung und Overlay bei gleichzeitig höherem Durchsatz und damit geringere Kosten als herkömmliche Projektionsstepper. Mit dieser erfolgreichen Produkt- und Technologiequalifizierung konnte SÜSS MicroTec seine Führungsposition im Advanced Packaging-Bereich ausbauen. Wenn es uns gelingt, weitere Kunden von unseren Systemen zu überzeugen, könnten wir auch in den kommenden Jahren weiter substanzielle Auftragsvolumina und Umsätze mit Scannern erzielen. Bei entsprechend hohen Stückzahlen könnten zukünftig nachhaltig positive Margen erreicht werden.

Das Segment Substrat Bonder untergliedert sich in die beiden Teilbereiche temporäres und permanentes Bonden. Im Bereich temporäres Bonden konnte die Marktposition im Bereich der TSV-basierten 3D-Speicherchips weiter gefestigt werden, indem wir einen zweiten asiatischen Produktionskunden für einen Teil unserer Gerätelösung gewinnen konnten. Im Bereich permanentes Bonden wurde im Geschäftsjahr 2015 ein neuer halbautomatischer Wafer Bonder entwickelt und in den Markt eingeführt. Das halbautomatische System XB8 kann Wafergrößen bis 200 mm sowie verschiedene Substratgrößen und -typen bearbeiten und basiert auf der Steuerungsplattform des im Jahr 2014 entwickelten SB6/8 Gen2 Wafer Bonders. Durch die umfassenden Neuentwicklungen, die wir im Jahr 2015 durchgeführt haben und auch in den Folgejahren weiter fortsetzen werden, erwarten wir für die Zukunft einen deutlichen Ausbau unserer Marktposition, höhere Umsatzvolumina und langfristig positive Margen.

Im Segment Fotomaschinen Equipment haben wir seit der Akquisition der SÜSS MicroTec Photomask Equipment im Jahr 2010 hohe Umsätze und hohe Margen erzielt. Der Großteil der Umsätze wurde mit wenigen Einzelaufträgen erzielt, die jeweils einen sehr hohen Auftragswert von mehreren Millionen Euro

aufwiesen. Die Umsätze pro Geschäftsjahr weisen daher große Schwankungen auf. In diesem Segment sehen wir unsere Marktposition als sehr gefestigt an und gehen davon aus, auch in Zukunft hohe Gewinne zu erzielen. Wir rechnen jedoch damit, dass sich langfristig weiterhin starke Schwankungen im Umsatz pro Geschäftsjahr ergeben werden, was sich entsprechend auf das Segmentergebnis pro Geschäftsjahr auswirken kann.

Das Geschäft der SÜSS MicroOptics S.A. (Hauterive, Schweiz) hat sich im Jahr 2015 trotz des starken Schweizer Franken sehr positiv entwickelt. Im MicroOptics-Geschäft konnten im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzsteigerungen von knapp 34 % im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet werden. Im Jahr 2015 konnte erstmals der in den gemieteten Räumen neu eingebaute Reinraum vollständig genutzt werden. Durch die neuen Räumlichkeiten konnten bei der Produktion deutliche Effizienzsteigerungen erzielt werden. Dadurch konnten Margenverluste, die sich durch die nachteilige Entwicklung des Kurses des Schweizer Franken ergeben haben, teilweise kompensiert werden. Für die kommenden Jahre erwarten wir weitere Umsatzsteigerungen im MicroOptics-Geschäft und gehen davon aus, dass die SÜSS MicroOptics in Zukunft einen substanziellen Umsatz- und Ergebnisbeitrag zum Konzernergebnis leisten wird.

Finanzielle Chancen

Starke Veränderungen am Währungsmarkt können den Absatz und das Unternehmensergebnis von SÜSS MicroTec sowohl positiv als auch negativ beeinflussen. Der momentan gegenüber dem US-Dollar eher schwach notierende Euro bietet SÜSS MicroTec die Möglichkeit, seine in Deutschland hergestellten Produkte vor allem auf den US-Dollar-dominierten Märkten zu attraktiven Preisen anzubieten. Auch die Wertveränderungen des Euro im Vergleich zum japanischen Yen werden künftig den Absatz und die erzielbaren Margen im asiatischen Raum beeinflussen. Eine Aufwertung des Euro im Vergleich zum japanischen Yen würde sich eher negativ auswirken, während eine Abwertung voraussichtlich positive Effekte für SÜSS MicroTec nach sich ziehen würde.

Der Kurs des japanischen Yen im Vergleich zum Euro unterlag im abgelaufenen Geschäftsjahr starken Schwankungen. Während der japanische Yen zu Jahresbeginn 2015 noch bei 145,04 Yen für einen Euro notierte, lag der Kurs zum 31. Dezember 2015 bei 131,13 Yen pro Euro. In 2016 setzte sich diese Entwicklung fort, sodass der japanische Yen Ende Februar 2016 teilweise deutlich unter 125 Yen pro Euro notierte. Der momentan starke Yen-Kurs könnte die Verkaufszahlen diverser japanischer Wettbewerber, die vor allem im Markt für Belacker aktiv sind, negativ beeinflussen oder bei diesen Wettbewerbern für deutliche Margen einbußen sorgen. Sollte die Stärke des japanischen Yen anhalten

oder der Yen noch weiter aufwerten, sehen wir gute Chancen, Marktanteile von japanischen Wettbewerbern zu gewinnen und Margenverluste, die wir im Wettbewerb mit japanischen Anbietern hinnehmen mussten, wieder zu kompensieren.

Mitarbeiterspezifische Chancen

SÜSS MicroTec sieht sich selbst als mittelständisches Unternehmen, das aufgrund der relativ geringen Unternehmensgröße flache Hierarchien aufweist und so seinen Mitarbeitern in allen Belangen kurze Kommunikationswege und schnelle Entscheidungsprozesse ermöglicht. Unsere mittelständischen Strukturen in Verbindung mit unserer internationalen Ausrichtung machen SÜSS MicroTec zu einem attraktiven Arbeitgeber. Die durchschnittliche Betriebszugehörigkeit unserer weltweit tätigen Mitarbeiter beläuft sich auf beinahe zehn Jahre. Damit zeigen unsere Bemühungen, unseren Mitarbeitern ein gutes Betriebsklima, interessante Aufgaben und eine attraktive Vergütung zu bieten, ihren Erfolg. Wir sind überzeugt, dass wir auch zukünftig alle freien Stellen mit qualifizierten und motivierten Mitarbeitern besetzen können. Unsere bisherige Strategie, langjährige Mitarbeiter zu halten, werden wir unverändert fortsetzen.

Unser Vergütungs-System beinhaltet für unsere Führungskräfte eine variable Vergütung, deren Höhe sich nach dem Grad der Zielerreichung richtet. Die Ziele werden jährlich neu definiert und basieren auf bestimmten Kenngrößen des Konzerns (wie zum Beispiel EBITDA, Umsatz und Auftragseingang), die anhand der aktuellen Budgetplanung jährlich neu festgelegt werden. Zusätzlich werden mit dem Mitarbeiter persönliche Ziele vereinbart. Für die Mitarbeiter des Vertriebs werden in der Regel Ziele definiert, die im Zusammenhang mit der Gewinnung von Kundenaufträgen stehen. Die persönlichen Ziele von Mitarbeitern anderer Abteilungen haben meist Leistungen oder Projekte zum Inhalt, die einen Zusatznutzen für den jeweiligen Fachbereich mit sich bringen. Durch die Einbindung der Budgetplanung in das Vergütungs-System setzen wir für unsere Führungskräfte einen finanziellen Anreiz, aktiv dazu beizutragen, die gesetzten Ziele zu erreichen. Damit erhöhen wir unsere Chancen, unseren geplanten Umsatz und unser geplantes Ergebnis tatsächlich zu erzielen. Die Definition von persönlichen Zielen für die Führungskräfte bietet uns darüber hinaus die Chance, zahlreiche Projekte in verschiedenen Bereichen umzusetzen, auch wenn dafür ein Arbeitseinsatz der Mitarbeiter notwendig ist, der über das normale Tagesgeschäft hinausgeht.

Als weltweit erfolgreiches Technologie-Unternehmen ist SÜSS MicroTec darauf angewiesen, dass die Mitarbeiter, die im Bereich Forschung und Entwicklung tätig sind, neue Produktentwicklungen gezielt vorantreiben, um so den Bedürfnissen unserer Kunden Rechnung zu tragen. SÜSS MicroTec setzt hierzu die

entsprechenden Anreize und vergütet Ideen der Mitarbeiter, die in unseren Produkten zum Einsatz kommen, mit einer jährlich auszuzahlenden Erfindervergütung.

Unsere internationale Präsenz ermöglicht es uns, hochqualifizierte Mitarbeiter weltweit anzuwerben, wenn es aktuelle Entwicklungen erforderlich machen.

Entwicklungsspezifische Chancen

Im abgelaufenen Geschäftsjahr haben wir unsere Entwicklungsaktivitäten deutlich ausgebaut. Vor allem für die Produktlinien Mask Aligner und Belacker/Entwickler sowie für das Segment Fotomaschinen Equipment haben wir Mitarbeiter eingestellt und Entwicklungsprojekte auch mit Hilfe von externen Dienstleistern und Kooperationspartnern vorangetrieben. Diese Anstrengungen werden wir auch im kommenden Jahr fortsetzen. Unser Ziel ist es, unsere Produktlinien an die neuesten Entwicklungen im Markt anzupassen und neue Kundenanforderungen zu erfüllen. Damit wollen wir unsere Marktposition festigen und weiter ausbauen.

RISIKOMANAGEMENT-SYSTEM

Zur Erkennung und Steuerung von Risiken sowie zur Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen ist das Risikomanagement-System seit langem Bestandteil der Unternehmensführung.

Neben kurzfristigen (operativen) Risiken befasst sich das Risikomanagement bei SÜSS MicroTec auch mit langfristigen (strategischen) Entwicklungen, die sich negativ auf die Geschäftsentwicklung auswirken können. Auf der Grundlage eines chancenorientierten, gleichzeitig aber risikobewussten Managements ist es jedoch nicht unser Ziel, alle potenziellen Risiken grundsätzlich zu vermeiden. Vielmehr streben wir stets ein Optimum aus Risikovermeidung, -reduzierung und kontrollierter Risikoakzeptanz an. Das Bewusstsein für Risiken sollte nicht die Fähigkeit beeinträchtigen, Chancen zu erkennen und zum Wohle des Unternehmens und seiner Aktionäre zu nutzen.

Organisation und Dokumentation des Risikomanagements

Die Organisation des Risikomanagements orientiert sich an der funktionellen und hierarchischen Struktur des Konzerns. Mit der Einführung des Risikomanagement-Systems wurde ein Risikomanagement-Beauftragter ernannt, der alle drei Monate direkt an den Vorstand berichtet.

Extern wird das eingerichtete Risikofrüherkennungs-System durch den Abschlussprüfer im Rahmen der Jahresabschlussprüfung geprüft. Er berichtet darüber an Vorstand und Aufsichtsrat.

Risikoidentifikation

Alle berichtspflichtigen Einheiten des Konzerns veranstalten mindestens einmal jährlich einen Workshop, der neben der Retrospektive vor allem auf zukünftige Entwicklungen eingeht. Außerdem dienen die Workshops dazu, die konzernweit einheitliche Bewertungsmethodik sicherzustellen. Im Rahmen eines strukturierten Prozesses werden vierteljährlich sämtliche identifizierten Risiken mit Hilfe einer intranet-basierten IT-Lösung erfasst und bewertet. Anschließend werden Risikoberichte erstellt, die bekannte Risiken einer kritischen Würdigung unterziehen und neue Themen aufnehmen.

Plötzlich auftretende Risiken werden darüber hinaus unverzüglich an den Risikomanagement-Beauftragten der jeweiligen Einheit gemeldet.

Die Aufbereitung der Informationen erfolgt durch den Risikobeauftragten, der an den Vorstand berichtet. Die Ergebnisse des Gesamtprozesses werden dem Aufsichtsrat mindestens einmal jährlich präsentiert.

Wichtiger Bestandteil zur Risikofrüherkennung ist das Qualitätsmanagement des Konzerns. An den großen Produktionsstandorten liegt eine Zertifizierung nach ISO 9001 vor, die ein zuverlässiges, prozess- und systemorientiertes Qualitätsmanagement bestätigt. Klar strukturierte und eindeutig dokumentierte Prozesse im Rahmen des Qualitätsmanagements sorgen nicht nur für Transparenz, sondern sind mittlerweile bei den meisten Produktionskunden eine Vorbedingung für die erfolgreiche Vermarktung unserer Maschinen.

Risikobewertung

Die Bewertung von Risiken erfolgt zum einen durch die Angabe der maximalen Schadenshöhe, wenn keine Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Auf dieser Grundlage wird der Risikowert durch Einbeziehung einer Eintrittswahrscheinlichkeit ermittelt, wobei auch die entsprechenden Gegenmaßnahmen berücksichtigt werden. Die Angabe des Risikowerts bezieht sich jeweils auf den Zeitraum der kommenden zwölf bzw. 24 Monate.

Die identifizierten Risiken werden mit Hilfe einer Risikomatrix in drei verschiedene Risikokategorien eingeordnet, die sowohl die mögliche Schadenshöhe als auch die Eintrittswahrscheinlichkeit berücksichtigen. Risiken ab einer Schadenshöhe von 10 Mio. € – gemessen an der Höhe des Liquiditätsabflusses – werden als „bestandsgefährdend“ angesehen.

Die Kombination von Eintrittswahrscheinlichkeit und Grad der Auswirkung bestimmt, welche Risikokategorien aus Konzernsicht als wesentlich zu betrachten sind. Hierbei wird unterschieden in geringe (grün), mittlere (gelb) und hohe (rot) Risiken.

■ gering ■ mittel ■ hoch

		Eintrittswahrscheinlichkeit				
		sehr gering	gering	mittel	hoch	sehr hoch
		0% bis ≤ 5%	> 5% bis ≤ 10%	> 10% bis ≤ 25%	> 25% bis ≤ 50%	> 50% bis ≤ 100%
Auswirkung	bestandsgefährdend	> 10 Mio. € bis ≤ 20 Mio. €				
	schwerwiegend	> 2 Mio. € bis ≤ 10 Mio. €				
	bedeutend	> 500 Tsd. € bis ≤ 2 Mio. €				
	moderat	> 20 Tsd. € bis ≤ 500 Tsd. €				
	vertretbar	0 € bis ≤ 20 Tsd. €				

Entsprechend unserer Methode zur Risikobewertung werden nur die hohen Risiken als wesentlich eingestuft.

Risikohandhabung

Je nach Art des Risikos und der Höhe der Bewertung werden abgestuft Maßnahmen der Risikovermeidung bzw. -minderung getroffen. Dabei orientiert sich das Risikomanagement stets an der einleitend erwähnten Maxime eines chancenorientierten Umgangs mit Risiken.

Die Risikoabwendung und Organisation von Gegenmaßnahmen wird subsidiär durchgeführt. Die Risikoverantwortlichen beziehungsweise die Berichtseinheiten sind zur Entwicklung und Umsetzung von Abwehrstrategien gegen erkannte Risiken verpflichtet. Sollten ihre Kompetenzen nicht zur Umsetzung ausreichen, fordern sie Hilfe von höheren Ebenen an.

Aus der weltweiten Tätigkeit in der Hochtechnologie ergeben sich allgemeine und aktuelle Risiken für das Unternehmen. Der Vorstand hat zur Überwachung von Risiken in geeigneter Weise Maßnahmen getroffen, um Entwicklungen, die den Fortbestand der SÜSS MicroTec-Gruppe gefährden, rechtzeitig zu erkennen.

Beschreibung der wesentlichen Merkmale des internen Kontroll- und Risikomanagements im Hinblick auf den Konzernrechnungslegungsprozess gemäß § 289 Abs. 5 HGB und § 315 Abs. 2 Nr. 5 HGB

Das Risikomanagement-System im Hinblick auf den Konzernrechnungslegungsprozess zielt darauf ab, das Risiko der Falschaussage in der Konzernrechnungslegung sowie in der externen Berichterstattung zu minimieren. Es dient im ersten Schritt der Identifikation und Bewertung, weiterhin der Begrenzung und Überprüfung erkannter Risiken im Konzernrechnungslegungsprozess, die dem Ziel der Regelungskonformität des

Konzernabschlusses entgegenstehen könnten. Das interne Kontroll-System des Rechnungslegungsprozesses soll gewährleisten, dass trotz identifizierter Risiken in der Finanzberichterstattung ein mit hinreichender Sicherheit regelkonformer Konzernabschluss erstellt wird.

Die Angemessenheit des Risikofrüherkennungs-Systems wird im Rahmen der Abschlussprüfung zum Jahresende durch den Abschlussprüfer überprüft. Dabei werden ausgewählte rechnungslegungsbezogene interne Kontrollen untersucht und deren Effektivität beurteilt. Darüber hinaus werden ausgewählte Aspekte der eingesetzten IT-Systeme geprüft.

Die Verantwortung für die Einrichtung und wirksame Unterhaltung angemessener Kontrollen über die Finanzberichterstattung liegt beim Management der SÜSS MicroTec AG, das zu jedem Geschäftsjahresende die Angemessenheit und Wirksamkeit des Kontroll-Systems beurteilt. Zum 31. Dezember 2015 hat das Management die Wirksamkeit der internen Kontrollen über die Finanzberichterstattung festgestellt. Allerdings bestehen bei jedem Kontroll-System gewisse Einschränkungen hinsichtlich seiner Wirksamkeit. Eine absolute Sicherheit kann auch mit angemessenen und funktionsfähigen Systemen nicht gewährleistet werden.

Die SÜSS MicroTec AG nutzt ihr konzernweit gültiges Bilanzierungshandbuch zur einheitlichen Regelung von Bilanzierungsgrundsätzen. Das Bilanzierungshandbuch basiert auf den IFRS-Rechnungslegungsstandards und wird von allen Konzerngesellschaften beim Rechnungslegungsprozess zugrunde gelegt. Durch eindeutige Vorgaben soll der Ermessensspielraum der Mitarbeiter bei Ansatz und Bewertung von Vermögenswerten und Schulden eingeschränkt und somit das Risiko konzernuneinheitlicher Rechnungslegungspraktiken verringert werden. Den

Tochtergesellschaften sind bestimmte Berichtspflichten und -umfänge zwingend vorgegeben. Die Einhaltung der Berichtspflichten und -fristen wird durch die zentralen Abteilungen Finanzen und Controlling überwacht.

Die Buchhaltung der Tochtergesellschaften wird entweder lokal mit eigenen Mitarbeitern oder mit der Unterstützung von externen Buchführungsfirmen oder Steuerberatungsgesellschaften durchgeführt. Dabei werden unterschiedliche EDV-Systeme eingesetzt. Alle deutschen Gesellschaften arbeiten bereits seit 2008 mit SAP. Seit 2010 wird SAP bei der SÜSS MicroTec (Taiwan) Company Ltd., Hsinchu (Taiwan), verwendet. 2011 wurde SAP bei der SÜSS MicroTec, Inc., Sunnyvale (Kalifornien, USA) implementiert. In 2015 wurde die SÜSS MicroTec Photonic Systems Inc. (Kalifornien, USA) an das konzernweite SAP-System angeschlossen; das „Go-Live“ erfolgte zum 1. Mai 2015. Das Reporting an die Konzernzentrale erfolgt mit Hilfe der Managementinformations-Software „INFOR PM Application Studio“. Die Einzelabschlüsse werden über ein zentrales Konsolidierungs-System zusammengeführt. Auf Konzernebene wird innerhalb der Finanzabteilung und des Controllings die Ordnungsmäßigkeit und Verlässlichkeit der von den Tochtergesellschaften vorgelegten Einzelabschlüsse überprüft. Kontrollen im Rahmen des Konsolidierungsprozesses, wie beispielsweise der Schulden- oder der Aufwands- und Ertragskonsolidierung, erfolgen manuell. Eventuelle Mängel werden korrigiert und an die Tochtergesellschaften zurück berichtet. Die eingesetzten Finanz-Systeme sind durch entsprechende Berechtigungskonzepte und Zugangsbeschränkungen vor Missbrauch geschützt. Zugriffsberechtigungen werden regelmäßig überprüft und gegebenenfalls aktualisiert.

RISIKEN DES KONZERNS

Gesamtwirtschaftliche Risiken

SÜSS MicroTec ist weltweit vertreten, weist eine breite Kundenstruktur auf und bietet seinen Kunden sieben unterschiedliche Produktlinien an, die in verschiedenen Branchen und Industriezweigen eingesetzt werden können. Damit ist SÜSS MicroTec grundsätzlich weder von einzelnen Märkten noch von einzelnen Abnehmern abhängig. Konjunkturelle Einbrüche in einer Region oder Branche können somit zumindest teilweise aufgefangen werden. Dank der flexiblen Aufstellung wäre SÜSS MicroTec bei größeren konjunkturellen Verwerfungen in der Lage, unverzüglich auf die Marktgegebenheiten zu reagieren und die Kostenstrukturen in angemessener Zeit anzupassen. Als Instrumente stehen Gleitzeitkonten, der Einsatz von Zeitarbeitskräften sowie Outsourcing-Maßnahmen zur Verfügung. Darüber hinaus besteht die Option, Kurzarbeit zu beantragen. Zudem werden von den Einkaufsabteilungen regelmäßig die Beschaffungsmengen überprüft und angepasst.

Politische Entscheidungen, neue Gesetzgebungen und sonstige Regularien in den Ländern, in denen SÜSS MicroTec tätig ist, können unser Geschäft negativ beeinflussen. Dazu gehören die Steuergesetzgebung in den jeweiligen Ländern, Exportbeschränkungen sowie Verschärfungen in den Bereichen Produkthaftung, Wettbewerbsrecht, Arbeitssicherheit und Patent- und Markenrecht.

SÜSS MicroTec nimmt regelmäßig an öffentlichen Ausschreibungen teil und zählt zum Beispiel Universitäten und staatliche Forschungseinrichtungen weltweit zu seinen Kunden. Die Regelungen für die Teilnahme an öffentlichen Ausschreibungen und die Kriterien für die Vergabe unterscheiden sich je nach Land und können das Gewinnen von öffentlichen Aufträgen und deren Abwicklung deutlich erschweren.

Generell können starke Veränderungen am Währungsmarkt den Absatz und das Unternehmensergebnis von SÜSS MicroTec sowohl positiv als auch negativ beeinflussen. Der momentan im Vergleich zum US-Dollar schwach notierende Euro bietet SÜSS MicroTec die Möglichkeit, seine in Deutschland hergestellten Produkte vor allem auf den US-Dollar-dominierten Märkten zu attraktiven Preisen anzubieten. Auch die Wertveränderungen des Euro im Vergleich zum japanischen Yen werden künftig den Absatz und die erzielbaren Margen im asiatischen Raum beeinflussen. Eine Aufwertung des Euro im Vergleich zum japanischen Yen würde sich eher negativ auswirken, während eine Abwertung voraussichtlich positive Effekte für SÜSS MicroTec nach sich ziehen würde.

Der im Vergleich zum Euro sehr stark notierende Schweizer Franken hat keine spürbaren Auswirkungen auf das Bestellverhalten unserer Kunden in den Segmenten Lithografie, Substrat Bonder und Fotomasken Equipment. Allerdings ist das Geschäft der SÜSS MicroOptics S.A., die in Hauterive, Schweiz angesiedelt ist und Mikrolinsen herstellt, stark vom Wechselkurs des Schweizer Franken beeinflusst. Der starke Schweizer Franken hat 2015 zu spürbaren Margenverlusten der MicroOptics-Produkte geführt. Im abgelaufenen Geschäftsjahr konnten mit dem MicroOptics-Geschäft zwar Umsatzsteigerungen von knapp 34 % im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet werden. Wir gehen jedoch davon aus, dass das Wachstum noch deutlich stärker ausgefallen wäre, wenn sich der Kurs des Schweizer Franken nicht so nachteilig verändert hätte. Der Umsatz- und Ergebnisbeitrag, den die SÜSS MicroOptics zukünftig zum Konzernergebnis leisten wird, hängt wesentlich von der weiteren Entwicklung des Schweizer Franken ab.

Im Jahr 2015 waren starke Schwankungen des Euro gegenüber den meisten asiatischen Währungen zu beobachten. Betroffen hiervon waren der Kurs des Euro gegenüber dem taiwanesischen

Dollar, dem Singapur-Dollar, dem südkoreanischen Won und dem chinesischen Renminbi Yuan. Der SÜSS MicroTec-Konzern wickelt nur in sehr geringem Umfang Geschäfte in diesen Währungen ab. Die in Taiwan, Singapur, Südkorea und China ansässigen Tochtergesellschaften des Konzerns weisen jedoch in Euro dotierte Forderungen gegen Kunden und andere SÜSS MicroTec Gesellschaften aus. Je nach Umfang und Fälligkeit können aus der Bewertung dieser Forderungen in der jeweiligen Landeswährung signifikante Währungsverluste im Konzern entstehen.

Branchen- und marktspezifische Risiken

Die schwierige Einschätzbarkeit der kurz- und mittelfristigen Marktentwicklung gehört unverändert zu den größten Risiken des Unternehmens. Insbesondere die Halbleiter-Industrie, die zu unseren Absatzmärkten zählt, ist von starken Marktzyklen geprägt. Ein starker Einbruch des gesamten Halbleiter-Marktes würde bei SÜSS MicroTec Umsatzrückgänge nach sich ziehen und das Unternehmensergebnis schmälern. Den damit verbundenen Risiken begegnen wir durch schlanke Strukturen, die bei schwacher Geschäftsentwicklung zügig angepasst und gegebenenfalls durch Outsourcing ergänzt werden können.

Mitarberspezifische Risiken

In einzelnen Bereichen ist das Unternehmen von dem Wissen einzelner Mitarbeiter abhängig, vor allem im Bereich der Forschung und Entwicklung. Eine Nichtverfügbarkeit dieser Mitarbeiter für die Gruppe stellt ein entsprechendes Risiko dar, das durch interne Dokumentationspflichten kontrolliert wird.

Entwicklungsspezifische Risiken

Das Geschäftsmodell der SÜSS MicroTec-Gruppe basiert auf seiner starken Innovationskultur und Technologieführerschaft. Als Hersteller von Spezialmaschinen liefert SÜSS MicroTec kundenspezifische Lösungen und richtet seine Produktpolitik nach den sich schnell verändernden Bedingungen im Halbleiter-Equipment-Markt. Trotzdem sehen wir das Risiko, dass in Einzelfällen unsere technischen Entwicklungen die Vorstellungen der Märkte und unserer Kunden verfehlen könnten. In diesen Fällen bestünde die Gefahr, dass sich die betroffenen Kunden von SÜSS MicroTec abwenden und alternative technische Lösungen bei unseren Konkurrenten suchen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr haben sich unsere Ingenieure verstärkt um dieses Thema gekümmert und intensiv die Märkte und Kundenwünsche analysiert. Einige Neuentwicklungen, die auf spezielle Kundenwünsche eingehen, wurden auf den Markt gebracht und von unseren Kunden sehr gut angenommen. Damit sehen wir die Eintrittswahrscheinlichkeit für das beschriebene Risiko als deutlich geringer an.

Neben der Ausarbeitung von kundenspezifischen Lösungen arbeiten die Ingenieure der SÜSS MicroTec-Gruppe permanent an langfristigen Entwicklungsprojekten, die zukünftige Entwicklungen der Märkte antizipieren sollen, damit die Produkte von SÜSS MicroTec auch in Zukunft aktuelle technische Anforderungen erfüllen werden. Es besteht das Risiko, dass einzelne Entwicklungsprojekte nicht zum gewünschten Ergebnis führen oder das erzielte Ergebnis nicht die Erwartungen der Märkte trifft. In diesen Fällen bestünde die Gefahr, dass SÜSS MicroTec auf dem angestrebten Markt zeitweise kein innovatives Produkt anbieten kann. Die betroffenen Kunden könnten sich von SÜSS MicroTec abwenden und Alternativen am Markt suchen. Zudem hätte SÜSS MicroTec knappe Ressourcen im Bereich Entwicklung ungünstig eingesetzt. Im abgelaufenen Geschäftsjahr haben wir uns verstärkt auf diese Problematik konzentriert und die Zusammenarbeit zwischen unseren Ingenieuren und den asiatischen Vertriebsgesellschaften intensiviert, um besser auf die Vorstellungen unserer Kunden und potenziellen Kunden einzugehen. Damit konnten wir einige Erfolge erzielen und werden diese Form der Zusammenarbeit auch in Zukunft fortsetzen. Das beschriebene Risiko sehen wir nun als deutlich geringer an.

Für einige unserer Produkte sehen wir uns als Marktführer, da wir mit technologisch hochwertigen Lösungen die Anforderungen unserer Kunden passgenau erfüllen. Um diese Marktführerschaft und die Zufriedenheit unserer Kunden zu erhalten, sind laufend Neuentwicklungen und Verbesserungen an unseren bestehenden Produkten erforderlich (zum Beispiel um den weiteren Verkleinerungen der Strukturen in der Halbleiter-Industrie Rechnung zu tragen). Es besteht das Risiko, dass technische Neuentwicklungen von uns nicht rechtzeitig erkannt oder umgesetzt werden. In diesen Fällen sehen wir die Gefahr, dass SÜSS MicroTec seine Marktführerschaft in einzelnen Bereichen verlieren könnte und auf lange Sicht Umsatzeinbußen hinnehmen müsste.

Operative Risiken

Angesichts des hohen Bestands an flüssigen Mitteln, der hohen Eigenkapitalquote und der schlanken Kostenstruktur sind die Risiken, die sich für SÜSS MicroTec aus der aktuellen Vermögens- und Ertragslage ergeben könnten, begrenzt. Mit einem EBIT von 5,0 Mio. € hat der SÜSS MicroTec-Konzern 2015 zudem ein deutlich positives Ergebnis erzielt. Unter Berücksichtigung des zum Jahresende 2015 vorhandenen Auftragsbestands und der erwarteten Auftragseingangsentwicklung für das erste Halbjahr 2016 gehen wir davon aus, 2016 einen Umsatz in der Bandbreite zwischen 170 Mio. € und 180 Mio. € und ein positives EBIT zwischen 9 und 13 Mio. € zu erzielen.

Zum 31. Dezember 2015 weist SÜSS MicroTec einen Goodwill in Höhe von rund 15,8 Mio. € aus, der ausschließlich dem Segment Lithografie zuzuordnen ist. Das Segment Lithografie

erwirtschaftet mehr als die Hälfte des Konzernumsatzes und ein positives Segmentergebnis. Das Segment Lithografie wird auch im nächsten Jahr mehr als die Hälfte des gesamten Konzernumsatzes erwirtschaften und wird weiterhin profitabel sein. Für Wertminderungen im Segment Lithografie sehen wir daher keine Anzeichen.

Die Produktlinie Mask Aligner, die zum Segment Lithografie gehört, ist eine der umsatzstarken Produktlinien der SÜSS MicroTec-Gruppe und leistet seit vielen Jahren einen hohen Ergebnisbeitrag zum Konzernergebnis. Wir gehen fest davon aus, dass diese Produktlinie auch in den kommenden Jahren einen hohen Umsatzbeitrag und stabile Margen erzielen wird. Trotzdem besteht das Risiko, dass der Mask Aligner zukünftig die technischen Anforderungen der Kunden nicht mehr erfüllen kann und von anderen Technologien verdrängt werden könnte. Dieses Risiko sehen wir jedoch als gering an. Zudem kann SÜSS MicroTec seinen Kunden mit den in den USA angesiedelten Produktlinien, den Laser- und Scanner-Systemen, alternative Lösungen anbieten.

Auch die Produktlinie Belacker, die ebenfalls zum Segment Lithografie gehört, leistet seit vielen Jahren einen hohen Umsatz- und Ergebnisbeitrag zum Konzernergebnis. Seit Mitte 2013 nehmen wir zunehmend chinesische Wettbewerber wahr, die am Markt Kundenaufträge vor allem für technisch weniger anspruchsvolle Tools gewinnen konnten. Auch bringen japanische Hersteller, die teilweise bisher nur am Frontend-Markt tätig waren, verstärkt 300-mm-Systeme auf den Midend- / Backend-Markt und bieten den Kunden technologisch gute Lösungen an. In China mussten wir durch diese Entwicklung bereits Umsatzeinbußen hinnehmen. Es besteht das Risiko, dass sich diese Entwicklung fortsetzt und sowohl die japanischen als auch die chinesischen Hersteller zukünftig auch die technologisch anspruchsvollen Geräte, an denen SÜSS MicroTec bisher einen hohen Marktanteil hat, erfolgreich am Markt anbieten. Sollte dieses Szenario eintreten, müssten wir unsere Preise für die angebotenen Maschinen reduzieren, was Umsatz- und Margeneinbußen zur Folge hätte. Es ist nicht auszuschließen, dass wir trotz dieser Maßnahmen Marktanteile verlieren, wenn die konkurrierenden Hersteller aus Asien auf diesem Markt weiter Fuß fassen.

Im Segment Lithografie sind auch die Produktlinien der SÜSS MicroTec Photonic Systems für UV-Projektionsbelichtung und Laserprozessierung erfasst. Im abgelaufenen Geschäftsjahr wiesen diese Produktlinien ein negatives Ergebnis auf. Im Jahr 2015 konnten wir einen Großauftrag eines führenden Herstellers für Halbleiter-Industrie über eine nennenswerte Stückzahl von Projektionsscannern des Typs DSC300 Gen2 verbuchen. Mit dieser erfolgreichen Produkt- und Technologiequalifizierung konnte SÜSS MicroTec seine Führungsposition im Advanced

Packaging-Bereich weiter ausbauen. Der größte Teil des Umsatzes für diesen Auftrag wird 2016 realisiert werden. Aufgrund der technischen Spezifikation der bestellten Geräte und den damit verbundenen umfangreichen Entwicklungsleistungen rechnen wir für diesen Großauftrag mit einer geringen Marge. Demzufolge werden die Produktlinien der SÜSS MicroTec Photonic Systems insgesamt auch 2016 ein negatives Ergebnis erzielen. Ein positiver Ergebnisbeitrag kann mit den Photonic Systems-Produktlinien nur erzielt werden, wenn es uns gelingt, weitere Kunden von unseren Systemen zu überzeugen und damit weitere substanzielle Auftragsvolumina und Umsätze zu erzielen. Sollte es SÜSS MicroTec nicht gelingen, mit den Laser- und Scanner-Systemen substanzielle Umsätze und positive Margen zu erzielen, würden dadurch das Ergebnis des Segments Lithografie und das Konzernergebnis weiterhin negativ beeinflusst werden. Zudem könnte sich im Einzelabschluss der SÜSS MicroTec AG zusätzlicher Wertberichtigungsbedarf auf die Ausleihungen an die SÜSS MicroTec Photonic Systems Inc. ergeben, sofern die in den USA gefertigten Produktlinien dauerhaft ein negatives Ergebnis erzielen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr war das Segment Substrat Bonder erneut defizitär und erzielte ein Segment-EBIT von -4,0 Mio. €. Wir gehen davon aus, dass das Segment Substrat Bonder auch im kommenden Jahr ein negatives Ergebnis erzielen wird. SÜSS MicroTec hat allerdings seine Aktivitäten im Bereich Forschung und Entwicklung im abgelaufenen Geschäftsjahr nochmals deutlich verstärkt. Im Bereich permanentes Bonden wurde 2015 ein neuer halbautomatischer Wafer Bonder entwickelt und in den Markt eingeführt. Das halbautomatische System XB8 kann Wafergrößen bis 200 mm sowie verschiedene Substratgrößen und -typen bearbeiten und basiert auf der Steuerungsplattform des im Jahr 2014 entwickelten SB6/8 Gen2 Wafer Bonders. Weitere Produktinnovationen sind geplant. Wir gehen davon aus, dass wir mit diesen und weiteren Maßnahmen verlorene Marktanteile im Markt für permanentes Bonden wieder zurückgewinnen und unsere Marktposition ausbauen können. Trotzdem besteht das Risiko, dass wir auf dem Markt für permanentes Bonden die erforderlichen Stückzahlen nicht werden erreichen können. In diesem Fall würden die permanenten Bonder auch in Zukunft einen negativen Ergebnisbeitrag zum Segmentergebnis liefern. Zudem könnten davon auch andere Produktlinien negativ beeinflusst werden. So erwarten vor allem Forschungsinstitute und Universitäten, aber auch Kunden im Bereich MEMS, dass sie Mask Aligner, Belacker/Entwickler und Permanent Bonder von einem Anbieter beziehen können. Sollte es uns nicht gelingen unsere permanenten Bond-Systeme nachhaltig am Markt zu etablieren, wären auch bei den Produktlinien Belacker/Entwickler und Mask Aligner Umsatzeinbußen denkbar.

Auch im Bereich temporäres Bonden konnten wir im Jahr 2015 wichtige Meilensteine auf dem Weg zur Volumenproduktion erreichen. Im Bereich der TSV-basierten 3D-Speicherchips konnten wir unsere Marktposition festigen, indem wir einen zweiten asiatischen Produktions-Kunden für einen Teil unserer Geräte-lösung gewinnen konnten. Generell wird die 3D-Integration für die Volumenproduktion bei unseren Kunden noch nicht eingesetzt. Zudem besteht das Risiko, dass sich am Markt andere Technologien und Prozesse durchsetzen werden als die, die von SÜSS MicroTec entwickelt und angeboten werden. Der Erfolg unserer Technologie des Temporary Bonding und Debonding hängt entscheidend davon ab, ob sich die von uns entwickelten Technologien und Prozesse am Markt durchsetzen und ob sich die 3D-Integration in der industriellen Fertigung für die Volumenproduktion etablieren wird. Nur durch den Verkauf hoher Stückzahlen werden wir zukünftig im Segment Substrat Bonder unsere Margen verbessern und nachhaltig positive Ergebnisse erzielen können.

Im jetzigen Marktumfeld besteht unverändert ein deutlicher Preisdruck. Dieser beinhaltet das Risiko, dass auch bei sich erholenden Märkten ursprüngliche Zielverkaufspreise nicht mehr erzielt werden können. Diesem Risiko begegnen wir mit einer stetigen Preispolitik. So verzichten wir bei unattraktiven Konditionen auch auf Aufträge, um bei sich erholenden Märkten den Kunden gegenüber eine konsistente Preisgestaltung zu gewährleisten.

Die Produkte von SÜSS MicroTec werden durch ein umfassendes Risiko- und Qualitätsmanagement regelmäßig analysiert, kontrolliert und optimiert. Aufgrund des Einsatzes der Produkte im Produktionsumfeld von Unternehmen mit wachsenden Anforderungen an die Produktqualität kann sich das Haftungsrisiko für SÜSS MicroTec erhöhen. SÜSS MicroTec verfügt, neben anderen Versicherungen, über eine Produkthaftpflichtversicherung für die Gruppe, die das potenzielle Risiko soweit möglich limitiert. Die Angemessenheit dieser Versicherungen, in deren Schutz auch die Konzerngesellschaften einbezogen sind, wird regelmäßig hinsichtlich der abgedeckten Risiken und Deckungssummen überprüft und bei Bedarf angepasst. Darüber hinaus bemühen wir uns, mit allen Vertragspartnern Haftungsbeschränkungen in den Verträgen zu vereinbaren.

Risiken der Informationstechnologie

Grundsätzlich sehen wir unsere IT-Infrastruktur als gut ausgebaut an und sind der Meinung, dass wir ausreichend Vorkehrungen getroffen haben, um Datenmanipulationen, Datenverluste oder Datenmissbrauch zu vermeiden. Zudem investieren wir regelmäßig in neue Hard- und Software, um den Ausfall von IT-Systemen und Software-Lösungen möglichst gering zu halten. Mit Virenschaltern und Viren-Schutzprogrammen, die laufend auf dem aktuellen Stand gehalten werden, schützen wir unsere

IT-Systeme vor Zugriffen und Beschädigungen von außen. Trotzdem können wir nicht ausschließen, dass es in einzelnen Fällen zu Datenmanipulationen, Datenverlusten oder Datenmissbrauch kommen könnte. Es ist auch denkbar, dass neue Viren oder Trojaner, die von unseren Sicherheitsprogrammen nicht erkannt werden, in unsere IT-Systeme eindringen könnten. Verschärft wird das Problem durch die zunehmende Nutzung von mobilen Endgeräten wie Notebooks oder Smartphones, die auf unser Firmennetzwerk zugreifen. Um das Risiko fremder Zugriffe auf unser Firmennetzwerk, das sich durch die Nutzung von mobilen Endgeräten ergibt, möglichst gering zu halten, ist eine konzernweit geltende Richtlinie in Kraft, die den Umgang mit mobilen Endgeräten regelt.

Finanzielle Risiken

KREDITRISIKEN

Ein Kreditrisiko ist der unerwartete Verlust an Zahlungsmitteln oder Erträgen. Dieser tritt ein, wenn der Kunde nicht in der Lage ist, seinen Verpflichtungen innerhalb der Fälligkeit nachzukommen, oder die als Sicherheit dienenden Vermögenswerte an Wert verlieren. Das Unternehmen hat eine konzernweit gültige Richtlinie zum Thema „Credit Assessment“ implementiert. Diese Richtlinie legt für die einzelnen Vertriebsseinheiten des Unternehmens fest, welche Zahlungsbedingungen und Zahlungsabsicherungen im Einzelfall unter Berücksichtigung kunden- und länderspezifischer Aspekte vereinbart werden. Aufträge mit Kunden, die in sogenannten Risk Countries angesiedelt sind, können demzufolge nur gegen Anzahlung des gesamten Auftragswertes, einer Bankgarantie oder eines Letter of Credit abgewickelt werden. Im Fall von Kunden, die in sogenannten Non Risk Countries ansässig sind und eine bestimmte Größenordnung überschreiten, wird ein entsprechendes Kundenrating erstellt. Die Ratings beruhen auf den Angaben externer Kreditratingagenturen. Je nach Einstufung des Kunden sind für die Auftragsabwicklung abgestufte Zahlungskonditionen bzw. -absicherungen notwendig.

Vom Bruttobestand der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 13,6 Mio. € (Vorjahr: 13,7 Mio. €) sind zum Bilanzstichtag insgesamt 9,1 Mio. € (Vorjahr: 9,5 Mio. €) der Forderungen weder überfällig noch wertgemindert. Bei diesen Forderungen lagen zum 31. Dezember 2015 keine Anhaltspunkte vor, dass Zahlungsausfälle eintreten werden.

Die Altersstruktur der überfälligen, aber nicht wertgeminderten Forderungen stellt sich zum Bilanzstichtag und zum Vorjahresstichtag wie folgt dar:

in Tsd. €	2015	2014
Altersanalyse der überfälligen Forderungen ohne Wertberichtigung		
1–30 Tage	2.394	2.448
31–60 Tage	1.040	546
61–90 Tage	215	626
91–180 Tage	0	116
Überfällige Forderungen ohne Wertberichtigung	3.649	3.736

Insgesamt sind zum Bilanzstichtag 0,8 Mio. € (Vorjahr: 0,5 Mio. €) des Bruttoforderungsbestands überfällig und wertberichtigt.

Die Altersstruktur der überfälligen und wertberichtigten Forderungen zum Bilanzstichtag und zum Vorjahresstichtag ist in folgender Tabelle dargestellt:

in Tsd. €	2015	2014
Altersanalyse der überfälligen Forderungen mit Wertberichtigungen		
< 91 Tage	21	0
91–180 Tage	527	179
181–360 Tage	76	36
> 360 Tage	174	250
Überfällige Forderungen mit Wertberichtigung	798	465

Weitere Informationen zur Bestimmung von Wertberichtigungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen finden sich im Konzernanhang.

LIQUIDITÄTSRISIKEN

Zum Jahresende weist der SÜSS MicroTec-Konzern einen Net Cash-Bestand von 40,0 Mio. € aus (Vorjahr: 38,0 Mio. €). Der Free Cashflow (bereinigt um Effekte aus Wertpapiererwerben und Wertpapierverkäufen) belief sich im abgelaufenen Geschäftsjahr auf 1,3 Mio. € (Vorjahr: 2,1 Mio. €).

Zwischen der SÜSS MicroTec AG und der IKB Deutsche Industriebank AG besteht ein Darlehensvertrag, der der Finanzierung des Betriebsgrundstücks in Garching dient. Das Darlehen belief sich ursprünglich auf 7,5 Mio. €. Es wurde am 16. Dezember 2013 valutiert und zur Auszahlung gebracht und weist eine Laufzeit bis zum 30. Juni 2021 auf. Ein weiterer Darlehensvertrag besteht zwischen der SÜSS MicroTec AG und einer lokalen Volksbank und dient der Finanzierung des Betriebsgrundstücks in Sternenfels. Dieses Darlehen belief sich ursprünglich

auf 4,5 Mio. €. Es wurde am 6. Juli 2010 valutiert und zur Auszahlung gebracht und hat eine Laufzeit bis zum 30. Juni 2020. Zum 31. Dezember 2015 weist der SÜSS MicroTec-Konzern für diese beiden Darlehen Bankverbindlichkeiten von 9,1 Mio. € aus. Die jährliche Tilgung für die beiden Darlehen wird sich für die kommenden Jahre auf 1,2 Mio. € pro Jahr belaufen. Zudem fallen für die beiden Darlehen bankübliche Zinsen an.

Dem SÜSS MicroTec-Konzern stehen insgesamt Kredit- und Avallinien von 9,0 Mio. € bei nationalen und internationalen Bankinstituten und Versicherungen zur Verfügung. Drei Banken stellen der SÜSS MicroTec Lithography GmbH im Rahmen eines Bankenkonsortiums Kredit- und Avallinien von insgesamt 4,5 Mio. €. Diese Kredit- und Avallinien werden bis auf weiteres gewährt. Eine Bank des Konsortiums hat der SÜSS MicroTec Lithography GmbH darüber hinaus eine zusätzliche Avallinie über 1,0 Mio. € gewährt, die bis zum 30. April 2016 befristet ist. Eine weitere Kreditlinie in Höhe von 1,0 Mio. € steht der SÜSS MicroTec Photomask Equipment GmbH & Co. KG zur Verfügung. Darüber hinaus besteht im Rahmen eines Kautionsversicherungsvertrages ein weiterer Bürgschaftsrahmen in Höhe von 2,5 Mio. €, der von der SÜSS MicroTec Lithography GmbH und der SÜSS MicroTec REMAN GmbH genutzt werden kann. Diese Kredit- und Avallinien nutzen wir derzeit, um Anzahlungsbürgschaften im operativen Geschäft zu stellen. Zum 31. Dezember 2015 sind diese Kredit- und Avallinien in Höhe von 5,4 Mio. € in Form von Avalen in Anspruch genommen. Wir gehen fest davon aus, dass wir auch zukünftig alle erforderlichen Anzahlungsbürgschaften stellen können.

Die Minimierung der Abhängigkeit, insbesondere von kurzfristigem Fremdkapital, soll ein potenzielles Finanzierungsrisiko gering halten. Wir begegnen diesem Risiko vor allem durch das Ziel, mit entsprechenden Cashflows auch aus der Optimierung des Working Capital den Anteil des Fremdkapitals auf niedrigem Niveau zu halten. Weitere Einzelheiten zur Liquiditätssituation der Gesellschaft finden sich unter Textziffer (25) des Konzernanhangs.

MARKTPREISRISIKEN

Marktpreisschwankungen können für das Unternehmen signifikante Cashflow- sowie Gewinnrisiken zur Folge haben. Änderungen der Fremdwährungskurse und der Zinssätze beeinflussen sowohl das weltweite operative Geschäft als auch die Investitions- und Finanzierungsalternativen.

SÜSS MicroTec ist im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit aufgrund der internationalen Ausrichtung Fremdwährungsrisiken ausgesetzt. Die Währungssicherung erfolgt auf Basis bestehender Fremdwährungsaufträge. Für Aufträge, die binnen drei bzw. sechs Monaten abgearbeitet werden, beträgt die Sicherungsquote rund 65 % bzw. 45 %. Gegenläufige Zahlungsströme,

die sich insbesondere aus Fremdwährungsbestellungen von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen ergeben, werden von dem so ermittelten zu sichernden Fremdwährungsbetrag abgesetzt. Als Sicherungsinstrumente werden Devisentermingeschäfte genutzt. Für weitere Einzelheiten verweisen wir auf den Konzernanhang unter Textziffer (30).

Eine günstige Entwicklung der Fremdwährungskurse kann zu höheren Margen einzelner Aufträge führen und zusätzliche Kursgewinne generieren.

Das Zinsänderungsrisiko des Unternehmens ist begrenzt, da auf das variabel verzinsten Darlehen im Zusammenhang mit der Grundstücksfinanzierung Sternenfels ein laufzeitkongruenter Zinsswap gelegt wurde. Ursprünglich variable Konditionen

wurden dadurch in fixe Konditionen eingetauscht. Das Darlehen im Zusammenhang mit der Grundstücksfinanzierung Garching ist mit einem fixen Zinssatz belegt.

GESAMTEINSCHÄTZUNG

Im Konzern wurden im Geschäftsjahr 2015 keine bestandsgefährdenden Risiken identifiziert. Der Fortbestand des Unternehmens war unter Substanz- und Liquiditätsgesichtspunkten zu keiner Zeit gefährdet.

Die für den SÜSS MicroTec-Konzern wesentlichen Risiken sind in der folgenden Tabelle im Überblick dargestellt. Die Risiken wurden dabei nach der Eintrittswahrscheinlichkeit sowie nach den möglichen finanziellen Auswirkungen (gemessen an der Höhe des möglichen Liquiditätsabflusses) bewertet.

	Eintrittswahrscheinlichkeit					Auswirkung				
	<i>sehr gering</i>	<i>gering</i>	<i>mittel</i>	<i>hoch</i>	<i>sehr hoch</i>	<i>vertretbar</i>	<i>moderat</i>	<i>bedeutend</i>	<i>schwerwiegend</i>	<i>bestandsgefährdend</i>
	0 % bis ≤5 %	>5 % bis ≤10 %	>10 % bis ≤25 %	>25 % bis ≤50 %	>50 % bis ≤100 %	0 € bis ≤20 Tsd. €	>20 Tsd. € bis ≤500 Tsd. €	>500 Tsd. € bis ≤2 Mio. €	>2 Mio. € bis ≤10 Mio. €	>10 Mio. € bis ≤20 Mio. €
Gesamtwirtschaftliche Risiken										
Negative Auswirkungen durch Wechselkurs-schwankungen			X					X		
Entwicklungsspezifische Risiken										
Produktpolitik, Kundenzufriedenheit ¹			X						X	
Ungenügende Innovationsfähigkeit, verfehlte Entwicklungsprojekte ¹			X						X	
Verlust der Marktführerschaft in einzelnen Bereichen			X						X	
Operative Risiken										
Umsatzeinbußen bei Mask Alignern	X							X		
Verlust von Marktanteilen für Belacker				X					X	
Keine Profitabilität von UV-Projektionsbelichtung und Laserprozessierung			X					X		
Permanentes Bonden – Marktanteil kann nicht ausgebaut werden			X					X		
Temporäres Bonden – die von SÜSS MicroTec entwickelte Technologie setzt sich am Markt nicht durch			X					X		
Produkthaftung	X							X		
IT-Risiken										
Datensicherheit			X				X			

¹ Eintrittswahrscheinlichkeit Vorjahr: hoch

Prognosebericht

Das Geschäftsumfeld von SÜSS MicroTec wird durch die regionalen wie auch die weltweiten konjunkturellen Bedingungen sowie Branchenentwicklungen beeinflusst. In dem nachfolgenden Prognosebericht gehen wir auf die verschiedenen Faktoren ein, die das Unternehmen ebenso wie führende Markt- und Branchenbeobachter als maßgeblich für die weitere Geschäftsentwicklung ansehen.

Gemäß den Schätzungen des ifo Instituts München, wird sich das Weltwirtschaftsklima in den kommenden Monaten spürbar abkühlen. So lag der Indikator des ifo Index für die Weltwirtschaft im vierten Quartal 2015 nur noch bei 89,6 Punkten und damit deutlich unter dem Vorquartalswert von 95,9 Punkten sowie unter dem langfristigen Durchschnitt von 96,1 Punkten. Dabei hat sich die Einschätzung der aktuellen Lage nur wenig verschlechtert, allerdings ist der Ausblick weniger positiv als im Vorquartal. Insgesamt verschlechterte sich das Weltwirtschaftsklima in nahezu allen Regionen. In Europa und Nordamerika liegt der Indikator trotz der Eintrübung über seinem langfristigen Durchschnitt, in Asien, Lateinamerika, im Nahen Osten und Afrika jedoch deutlich darunter. Das Klima in Europa, Nordamerika und Lateinamerika trübte sich vor allem aufgrund der weniger positiven Konjunkturerwartungen ein. Dagegen waren in Asien, im Nahen Osten und Afrika beide Klimakomponenten, Lage und Erwartung, für die Verschlechterung ausschlaggebend. Insbesondere die anhaltende Schwächephase der chinesischen Wirtschaft belastet die globale Konjunktur und deren Ausblick. Gemäß den Schätzungen der OECD vom 18. Februar 2016 betrug das globale Wirtschaftswachstum 3,0% im Jahr 2015 und wird 2016 erneut um 3,0% wachsen.

Die gesamte Europäische Union sowie die Eurozone werden gemäß der Erwartungen der Europäischen Kommission auch im Wirtschaftsjahr 2016 erneut leicht positive Wachstumsraten aufweisen. Die OECD erwartet für die Eurozone für 2015 und 2016 jeweils ein Wachstum von 1,5% bzw. 1,4%. Für die Europäische Union insgesamt geht man im gleichen Zeitraum von einem leicht höheren Plus von zunächst 1,9% und im Jahr 2016 von einer Zunahme des realen Bruttoinlandsprodukts um 2,0% aus. Getragen wird das Wachstum durch starke Exporte, die dem vergleichsweise schwachen Euro geschuldet sind, sowie dem niedrigen Ölpreis und dem dadurch gestiegenen zur Verfügung stehenden Einkommen.

Im Dezember-Monatsbericht der Deutschen Bundesbank ist zu lesen, dass die deutsche Wirtschaft im Geschäftsjahr 2015 überwiegend durch die lebhaftere Binnennachfrage getragen wurde. In den neuesten Schätzungen der OECD geht man von einem leicht verlangsamten Wirtschaftswachstum in Deutschland für 2016 aus, die Zuwachsrate wird voraussichtlich bei 1,3% nach 1,4% im Jahr 2015 liegen.

Branchenspezifische Rahmenbedingungen

HALBLEITER-INDUSTRIE

Das Marktforschungsinstitut Gartner hat am 7. Januar 2016 in einer Pressemeldung seine aktuellen Erwartungen für die Entwicklung des gesamten Halbleiter-Marktes veröffentlicht. War man noch im April bzw. Juli 2015 von einem Wachstum des Halbleiter-Marktes um 4,0 bzw. 2,2% ausgegangen, so wird laut den aktuellsten Schätzungen sogar ein leichter Rückgang in der Branche um 1,9% gegenüber Vorjahr erwartet. Im Geschäftsjahr 2015 lag das Marktvolumen somit bei 333,7 Mrd. USD nach 340,3 Mrd. USD im Vorjahr. Die Gründe hierfür sind im Wesentlichen die erneut reduzierten Absatzprognosen für Smartphones, Tablets und PCs sowie der anhaltend starke US-Dollar, welcher die Nachfrage nach Elektronikprodukten außerhalb der USA dämpft. Für das Geschäftsjahr 2016 ist man wieder optimistischer und erwartet, dass der Halbleiter-Markt erneut wachsen und ein Gesamtvolumen von 344,1 Mrd. USD erreichen wird (Gartner Oktober 2015).

Wie sich in den vergangenen Jahren gezeigt hat, ist die Prognosegenauigkeit aufgrund der Besonderheiten und der ausgeprägten Zyklizität im Halbleiterbereich sehr begrenzt: so unterscheiden sich einige Schätzungen der Marktforschungsinstitute auch zum Jahresende 2015 deutlich von den eigenen Schätzungen im Vergleich zum Jahresanfang. Vor diesem Hintergrund stellen die nun folgenden Ausführungen Einschätzungen dar, die auf Basis der

zum derzeitigen Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen getroffen wurden, aber keine Garantie für das tatsächliche Eintreten der Prognosen bieten.

HALBLEITER-EQUIPMENT-INDUSTRIE

Der gesamte Halbleiter-Equipment-Markt hat sich in den Jahren 2010 bis 2015 extrem volatil gezeigt, positive Wachstumsraten von rund 9 % im Jahr 2011 waren gefolgt von deutlichen Rückgängen um 15 % bzw. 14 % in den Jahren 2012 und 2013, um dann im Jahr 2014 wieder ein Wachstum von rund 18 % auszuweisen. Für 2015 geht Semi von einem leichten Rückgang um 0,6 % aus. Auch der Ausblick für 2016 ist eher moderat, so erwartet man für das laufende Jahr ein Wachstum im Halbleiter-Equipment-Bereich um moderate 1,4 %. Damit dürfte der Halbleiter-Equipment-Markt im Jahr 2016 auf ein Volumen von rund 37,8 Mrd. USD wachsen, 2015 waren es entsprechend 37,3 Mrd. USD.

Nach Aussage des Branchenverbands Semi wurde 2015 überwiegend in Maschinen für die Herstellung von Speicherchips, insbesondere für DRAMs mit einer Strukturgröße von 21/20 nm, investiert. Dieser Trend wird sich 2016 deutlich abschwächen, denn im laufenden Geschäftsjahr werden zunehmend Investitionen für Flash-Speichermedien unterstellt.

Für das Backend der Halbleiter-Industrie, dem Hauptabsatzmarkt für SÜSS MicroTec-Maschinen, erwartet Gartner für 2016 in seinen Schätzungen vom 11. Januar 2016 einen leichten Rückgang des Equipment-Marktvolumens im Bereich Wafer-Level Packaging und Assembly um rund 0,1 % gegenüber 2015 (Vorjahr plus 4,4 %). Auch für diese Prognosen gilt die Aussage, dass die Erwartungen der Marktforschungsinstitute sich im Zeitablauf häufig deutlich verändern und gesicherte Prognosen nicht möglich sind.

Markt für Wafer-Level Manufacturing Equipment in Mrd. USD



Quelle: Gartner, Januar 2016

Erwartete Entwicklung in den Hauptmärkten

MIKROSYSTEMTECHNIK (MEMS)

Der Markt für Mikroelektromechanische Systeme entwickelt sich weiterhin sehr dynamisch. Den Schätzungen des Marktforschungsinstitutes Yole Développement zu Folge hatte der MEMS-Markt im Jahr 2000 ein Volumen von rund 5 Mrd. USD. Im Jahr 2014 waren es bereits 11,1 Mrd. USD und Yole erwartet für 2020 ein Marktvolumen von über 20 Mrd. USD. Das Stückzahlenwachstum der einzelnen MEMS-Bausteine ist bedeutend höher, durch Preisdruck und neue Designs wächst das Marktvolumen allerdings langsamer als die Stückzahlen. Für die Equipment-Branche ist zudem zu berücksichtigen, dass durch Effizienzgewinne, Durchsatz- und Yield-Erhöhungen sowie durch den Trend zu größeren Wafer-Durchmessern das Wachstum im Maschinenbereich erheblich geringer ausfallen wird. Yole erwartet in seinen Schätzungen vom Juni 2015 nur für den Bereich Lithografiemaschinen ein durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum 7 % (CAGR) bis zum Jahr 2020. Neben Lithografiegeräten kommen bei der MEMS-Herstellung auch Bonder von SÜSS MicroTec zum Einsatz. Aus diesem Grund wird der MEMS-Markt auch in Zukunft ein sehr attraktives Geschäftsfeld für SÜSS MicroTec sein.

Bei einem genaueren Blick auf die einzelnen Arten von MEMS-Sensoren wird deutlich, dass der Bereich Konsumelektronik mit einem Volumen von rund 6,4 Mrd. USD schon heute den mit Abstand größten Anwendungsbereich darstellt und zudem zukünftig das größte Wachstum aufweisen wird. Der Anteil am gesamten MEMS-Markt lag 2015 bereits bei über 50%. Getrieben wird diese Entwicklung durch das Internet of Things, die rapide zunehmende Vernetzung sowie die damit einhergehende Verbreitung von tragbarer Elektronik in Form von Uhren oder Armbändern. Der zweitstärkste Wachstumsbereich wird nach

Markt für MEMS in Mrd. USD



Quelle: Yole, Mai 2015

Erwartungen von Yole Développement die Medizintechnik sein. Ausgehend von einem bislang geringen Marktvolumen von rund 700 Mio. USD, werden auch hier zweistellige jährliche Wachstumsraten bis 2020 erwartet.

ADVANCED PACKAGING UND 3D-INTEGRATION

Unter dem Begriff Advanced Packaging subsummiert man heute verschiedene Technologien, wie beispielsweise das Wafer-Level Packaging (WLP), wo die jeweilige Kontaktierung bereits stattfindet, während die einzelnen Chips sich noch auf dem Wafer befinden. Dazu gibt es die Unterformen Fan-in und Fan-out WLP, Flip Chip-Bonding, Wafer-Level Chip-Scale Packaging sowie die 2,5D-Integration und die 3D-Integration. SÜSS MicroTec ist insbesondere mit seinen Lithografie- und Temporary Bonding-Lösungen in diesem Feld aktiv.

Laut einer Analyse des Marktforschungsinstituts Gartner (Januar 2016) ist der Markt für Wafer-Level Packaging und Assembly Equipment im Jahr 2015 um 4,4% auf rund 1,8 Mrd. USD gewachsen (Vorjahr plus 14,3%). In einer älteren Studie vom Juli 2015 erwartete Gartner für 2015 noch ein Wachstum in Höhe von 5,3%. Nach aktuellsten Schätzungen vom Januar 2016 wird dieser Bereich im Jahr 2016 leicht um 0,1% schrumpfen, um dann 2017 mit einem kräftigen Wachstum von 14,6% auf den positiven Wachstumspfad zurückzukehren. Laut Marktforschungsinstitut Yole Développement werden insbesondere Maschinenbauer aus dem Bereich Lithografie für Applikationen und Endanwendungen wie MEMS, Advanced Packaging und LED von diesem Trend profitieren. SÜSS MicroTec hat bereits 2015 mit seinen Lithografie-Lösungen für moderne Fan-out WLP-Anwendungen wichtige, großvolumige Aufträge verbuchen können.

Die 3D-Integration ist die weiterentwickelte Form der heute eingesetzten Advanced Packaging-Technologien, hierbei werden gedünnte Mikrochips übereinander gestapelt und durch TSVs (Thru Silicon Vias) miteinander verbunden. Die Vorteile sind eine große Packungsdichte und eine hohe Komplexität, die auf kleinstem Raum erreicht werden kann. Durch die 3D-Integration ist es zudem möglich, verschiedene Funktionalitäten, wie beispielsweise Speicher und Prozessor, in einem Package zu vereinigen.

Im Prognosebericht des Geschäftsberichts 2014 haben wir geschrieben, dass gemäß den Erwartungen des Marktforschungsinstituts Yole das Jahr 2015 eine besondere Bedeutung haben könnte. Nachdem im Jahr 2014 verschiedene Speicherchiphersteller den Einstieg in die Vorserienproduktion bzw. die Produktion von Prototypen bekannt gegeben hatten, wurden für 2015 erste Aufträge für den Übergang zur Volumenproduktion erwartet. Zurückblickend stellen wir fest, dass im Geschäftsjahr 2015 weiterhin nennenswerte Investitionen in diese Technologie getätigt wurden, aber der Einstieg in die Großserienproduktion bei keinem Unternehmen stattgefunden hat. SÜSS MicroTec ist dennoch zuversichtlich, dass diese Technologie zukünftig zum Umsatz- und Ergebniswachstum des Unternehmens beitragen wird. Allerdings ist es aufgrund der bisherigen Verzögerung aus heutiger Sicht extrem schwer, den zeitlichen Aspekt näher zu benennen. In der Zwischenzeit profitiert das Unternehmen von anderen neuartigen Packaging-Technologien, die bereits in nennenswertem Volumen zum Einsatz kommen laufen und zudem großes Potenzial haben, wie beispielsweise 2,5D oder Fan-out WLP oder Copper-pillar Bumping.

Markt für Wafer-Level Packaging und Assembly Equipment in Mrd. USD



Quelle: Gartner, Januar 2016

VERBINDUNGSHALBLEITER (LED)

Der Markt für Verbindungshalbleiter spielt für SÜSS MicroTec eine eher untergeordnete Rolle. Nur die Jahre 2010 und 2011 haben hierbei eine Ausnahme dargestellt. 2015 lag der Anteil am Gesamtumsatz erneut deutlich unter 10 % und aus heutiger Sicht ist ein Anstieg dieses Anteils nicht abzusehen. Die LED-Industrie wird zukünftig nicht mehr primär durch den Verkauf einzelnen LEDs für Bildschirme geprägt sein, sondern der Trend geht zu ganzen Lichtmodulen für die generelle Beleuchtung. Hier erwartet Yole Développement einen Anstieg des Marktvolumens von rund 3 Mrd. USD im Jahr 2015 auf bis zu 10 Mrd. USD bis 2020.

Endogene Indikatoren

Neben der Entwicklung in den Zielmärkten ist für den Geschäftserfolg das Innovationspotenzial entscheidend. SÜSS MicroTec ist auch im Geschäftsjahr 2015 wichtige Entwicklungskooperationen mit namhaften Partnern aus Industrie und Forschung eingegangen. Kooperationen mit renommierten Universitäten und Forschungsinstituten sowie technologiegetriebenen Unternehmen sind ein wichtiger Bestandteil unserer Unternehmensstrategie.

Im Januar 2015 hat SÜSS MicroTec die Zusammenarbeit mit Nuflare Technology, einem japanischen Equipment-Hersteller, begonnen. Mit dieser Zusammenarbeit stärkt das Unternehmen gezielt das Segment Fotomasken Equipment. In diesem Bereich hat Nuflare eine sehr gute Marktposition und man wird gemeinsam an zukunftssträchtigen Technologien und neuen Prozesslösungen im Bereich Fotomasken Equipment arbeiten. Darüber hinaus wurde im ersten Halbjahr 2015 eine Kooperation mit dem Georgia Institute of Technology (Georgia Tech) begonnen. Georgia Tech wird mit uns insbesondere auf den Gebieten Nanotechnologie, bio-medizinische Anwendungen und Halbleiter-Packaging (3D) zusammenarbeiten. Seit Jahresanfang 2015 ist SÜSS MicroTec zudem Mitglied in Georgia Tech's Packaging Research Center (PRC). Dort werden fortschrittliche Belichtungssysteme, wie beispielsweise Excimer Laser-Ablationssysteme zum Via-drilling auf nicht-fotosensitiven Materialien eingesetzt und erforscht.

Im August 2015 haben SÜSS MicroTec und das Singh Center für Nanotechnologie der Universität von Pennsylvania (Penn) eine Zusammenarbeit im Bereich der Nanoimprinting-Technologien angekündigt. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit hat Penn Maschinen und das technologische Know-how für das SCIL-Verfahren (Substrate Conformal Imprint Lithography) erhalten, das die Leistungsfähigkeit des bereits an der Penn installierten Mask Aligner MA/BA6 Gen3 deutlich erweitern. Bei der SCIL-Technologie handelt es sich um ein Nanoimprinting-Verfahren,

das die Vorteile der weichen und starren Stempel vereint und so die Reproduzierung großflächiger Strukturen bei einer Auflösung von unter 50 nm ermöglicht. SCIL kommt in vielfältigen Bereichen zum Einsatz, von HB-LEDs und Photovoltaik über MEMS und NEMS bis hin zur Massenproduktion von optischen Gittern für die Gassensorik und die Telekommunikation.

Gesamtaussage zur voraussichtlichen Entwicklung des Konzerns – Ausblick 2016

Aufgrund des Auftragsbestands zum Jahresende 2015 und der erwarteten Auftragseingangsentwicklung für das erste Halbjahr 2016 prognostiziert das Unternehmen einen Umsatz für das laufende Geschäftsjahr in der Bandbreite zwischen 170 und 180 Mio. € sowie ein positives Ergebnis (EBIT) zwischen 9 und 13 Mio. €.

In einem von kurzfristigen Kundenentscheidungen geprägten Marktumfeld gehen wir für das erste Halbjahr 2016 von einer moderaten Auftragseingangsentwicklung aus. Für das zweite Halbjahr 2016 erwarten wir eine Belebung der Nachfrage nach unseren Produkten und Lösungen, werden jedoch im Gesamtjahr 2016 voraussichtlich einen Auftragseingang unter dem Niveau des Vorjahres ausweisen. Für das Geschäftsjahr 2016 streben wir zudem einen ausgeglichenen Cashflow an.

Nach einem extrem starken vierten Quartal 2015 wird für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2016 ein Auftragseingang in Höhe von 25 bis 35 Mio. € erwartet.

Das Segment Lithografie wird im Geschäftsjahr 2016 erneut den größten Umsatz- und Ergebnisbeitrag für den Konzern liefern. Auf Basis des zum Jahresende 2015 gebuchten Auftragsbestands und der Auftragseingangserwartung für das erste Quartal 2016, rechnen wir gegenüber 2015 mit einem deutlich erhöhten Umsatz und EBIT. Letzteres wird im Bereich 14 bis 17 Mio. € erwartet. Für das Segment Substrat Bonder erwarten wir einen Umsatzanstieg und ein gegenüber dem Vorjahr leicht verbessertes aber dennoch negatives EBIT im niedrigen einstelligen Millionenbereich. Die Umsätze und das EBIT des Segments Fotomasken Equipment werden im kommenden Jahr erwartungsgemäß auf einem ähnlichen Niveau wie im Vorjahr liegen. Am Ziel, das organische Wachstum unseres Basisgeschäfts ohne zusätzliche Fremdmittel bestreiten zu können, halten wir weiterhin fest.

Zukunftsgerichtete Angaben

Dieser Bericht enthält Angaben und Prognosen, die sich auf zukünftige Entwicklungen des SÜSS MicroTec-Konzerns und seiner Gesellschaften beziehen. Die Prognosen stellen Einschätzungen dar, die wir auf Basis aller uns zum derzeitigen Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen getroffen haben. Sollten die den Prognosen zu Grunde gelegten Annahmen nicht eintreffen oder Risiken – wie die im Risikobericht angesprochenen – eintreten, so können die tatsächlichen Ergebnisse von den derzeit erwarteten Ergebnissen abweichen.

Garching, 9. März 2016



Dr. Per-Ove Hansson
Vorstandsvorsitzender



Michael Knopp
Finanzvorstand



Walter Braun
Produktionsvorstand

Konzernabschluss nach IFRS

der SÜSS MicroTec AG für das Geschäftsjahr 2015

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung (IFRS)	86
Gesamtergebnisrechnung (IFRS)	87
Konzernbilanz (IFRS)	88
Konzernkapitalflussrechnung (IFRS)	90
Konzerneigenkapital-Veränderungsrechnung (IFRS)	92
Entwicklung des Konzern-Anlagevermögens 2015	94
Entwicklung des Konzern-Anlagevermögens 2014	96
Segmentberichterstattung (IFRS)	98
Anhang zum IFRS-Konzernabschluss	100
Erläuterungen zur IFRS-Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung	110
Erläuterungen zu den Aktiva	115
Erläuterungen zu den Passiva	118
Sonstige Angaben	125
Versicherung der gesetzlichen Vertreter	138

Vollautomatische Belichtungssysteme für den Einsatz in der Serienfertigung



Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung (IFRS)

in Tsd. €	Anhang	01.01.2015–31.12.2015	01.01.2014–31.12.2014
Umsatzerlöse	(3)	148.516	145.331
Umsatzkosten	(4)	-99.154	-96.519
Bruttoergebnis vom Umsatz		49.362	48.812
Vertriebskosten		-18.811	-17.520
Forschungs- und Entwicklungskosten		-12.787	-10.490
Verwaltungskosten		-13.286	-14.189
Sonstige betriebliche Erträge	(5)	4.869	4.478
Sonstige betriebliche Aufwendungen	(6)	-4.374	-2.695
Analyse des operativen Ergebnisses (EBIT)			
EBITDA (Earnings before Interest and Taxes, Depreciation and Amortization)		9.156	12.645
Abschreibungen auf Sachanlagen, immaterielle Vermögenswerte und Finanzanlagen	(10)	-4.183	-4.249
Operatives Ergebnis (EBIT)		4.973	8.396
Finanzerträge		258	349
Finanzaufwendungen		-526	-545
Finanzergebnis	(7)	-268	-196
Gewinn vor Steuern		4.705	8.200
Ertragsteuern	(8)	-4.480	-3.587
Gewinn		225	4.613
davon SÜSS MicroTec-Aktionäre		225	4.613
davon nicht beherrschende Anteile		0	0
Ergebnis je Aktie (unverwässert)	(9)		
Ergebnis je Aktie in €		0,01	0,24
Ergebnis je Aktie (verwässert)	(9)		
Ergebnis je Aktie in €		0,01	0,24

Gesamtergebnisrechnung (IFRS)

in Tsd. €	01.01.2015 – 31.12.2015	01.01.2014 – 31.12.2014
Periodenergebnis	225	4.613
Posten, die nicht aufwands- oder ertragswirksam umgegliedert werden		
Neubewertung leistungsorientierter Pensionspläne	-532	-982
Latente Steuern	165	199
Sonstiges Ergebnis nach Steuern für Bestandteile, die nicht aufwands- oder ertragswirksam umgegliedert werden	-367	-783
Posten die in späteren Perioden aufwands- oder ertragswirksam umgegliedert werden		
Marktwertänderungen der zur Veräußerung verfügbaren Wertpapiere	-11	-19
Fremdwährungsanpassung	2.765	2.918
Absicherung künftiger Zahlungsströme	76	-144
Latente Steuern	-18	53
Sonstiges Ergebnis nach Steuern für Posten, die in späteren Perioden aufwands- oder ertragswirksam umgegliedert werden	2.812	2.808
Im Eigenkapital zu erfassende Erträge und Aufwendungen	2.445	2.025
Summe der in der Periode erfassten Erträge und Aufwendungen	2.670	6.638
davon SÜSS MicroTec-Aktionäre	2.670	6.638
davon nicht beherrschende Anteile	0	0

Konzernbilanz (IFRS)

Aktiva in Tsd. €	Anhang	31.12.2015	31.12.2014
Langfristige Vermögenswerte		43.402	44.718
Immaterielle Vermögenswerte	(11)	4.266	4.471
Geschäfts- oder Firmenwert	(12)	15.772	15.546
Sachanlagen	(13)	20.263	20.198
Steuererstattungsansprüche	(19)	37	50
Sonstige Vermögenswerte	(14)	611	563
Latente Steueransprüche	(8)	2.453	3.890
Kurzfristige Vermögenswerte		133.804	123.246
Vorräte	(15)	68.719	58.883
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	(16)	13.093	13.390
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	(17)	221	204
Wertpapiere	(18)	0	1.026
Steuererstattungsansprüche	(19)	414	725
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	(20)	49.085	47.309
Sonstige Vermögenswerte	(21)	2.272	1.709
Bilanzsumme		177.206	167.964

<i>Passiva</i> in Tsd. €	<i>Anhang</i>	31.12.2015	31.12.2014
<i>Eigenkapital</i>		118.740	116.070
Eigenkapital der Aktionäre der SÜSS MicroTec AG		118.740	116.070
Gezeichnetes Kapital	(22)	19.116	19.116
Rücklagen	(22)	98.809	98.584
Kumuliertes übriges Eigenkapital	(22)	815	-1.630
<i>Langfristige Schulden</i>		13.108	13.929
Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	(23)	5.144	4.751
Rückstellungen	(24)	11	29
Finanzschulden	(25)	7.920	9.100
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten		33	49
<i>Kurzfristige Schulden</i>		45.358	37.965
Rückstellungen	(26)	2.362	3.238
Steuerschulden	(29)	3.327	1.495
Finanzschulden	(25)	1.186	1.187
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	(27)	6.545	5.807
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		8.472	3.446
Sonstige Verbindlichkeiten	(28)	23.466	22.792
<i>Bilanzsumme</i>		177.206	167.964

Konzernkapitalflussrechnung

in Tsd. €	01.01.2015–31.12.2015	01.01.2014–31.12.2014
Gewinn (nach Steuern)	225	4.613
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte	1.239	1.515
Abschreibungen auf Sachanlagen	2.944	2.734
Ergebnis aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen	42	6
Veränderung der Wertberichtigung auf das Vorratsvermögen	-407	-177
Veränderung der Wertberichtigung auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	149	-1.493
Zahlungsunwirksame Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-93	-512
Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen	-1.370	-340
Veränderung des Vorratsvermögens	-7.675	14.030
Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.289	362
Veränderung der übrigen Vermögenswerte	-624	860
Veränderung der Pensionsrückstellungen	393	991
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.670	-2.199
Veränderung der erhaltenen Anzahlungen	-88	-13.110
Veränderung der übrigen Verbindlichkeiten und Rückstellungen	383	-4.521
Veränderung der Steuerforderungen und Steuerverbindlichkeiten	3.593	2.324
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit	4.670	5.083

in Tsd. €	01.01.2015–31.12.2015	01.01.2014–31.12.2014
Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen	-2.609	-1.766
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte	-803	-1.190
Einzahlungen aus Einlösung von zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren	1.000	1.028
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-2.412	-1.928
Tilgung von Bankdarlehen	-1.180	-1.180
Veränderung der übrigen Finanzverbindlichkeiten	-1	-4
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-1.181	-1.184
Wechselkursbedingte Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	699	279
Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1.776	2.250
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Jahresanfang	47.309	45.059
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Ende der Periode	49.085	47.309
Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit enthält		
Zinszahlungen während der Periode	406	427
Zinseinnahmen während der Periode	272	309
Steuerzahlungen während der Periode	865	1.179
Steuererstattungen während der Periode	129	63

Konzerneigenkapital-Veränderungsrechnung (IFRS)

in Tsd. €	Gezeichnetes Kapital	Kapitalrücklage	Gewinnrücklage	Bilanz- gewinn / Verlust
<hr/>				
<hr/>				
<hr/>				
Stand 01.01.2014	19.116	97.614	433	-4.076
Periodenergebnis				4.613
Im Eigenkapital zu erfassende Erträge und Aufwendungen				
Gesamtergebnis				4.613
Stand 31.12.2014	19.116	97.614	433	537
Stand 01.01.2015	19.116	97.614	433	537
Periodenergebnis				225
Im Eigenkapital zu erfassende Erträge und Aufwendungen				
Gesamtergebnis				225
Stand 31.12.2015	19.116	97.614	433	762

<i>Kumuliertes übriges Eigenkapital</i>							<i>Eigenkapital der Aktionäre der SÜSS MicroTec AG</i>	<i>Nicht beherrschende Anteile</i>	<i>Eigenkapital</i>
Posten, die nicht aufwands- oder ertragswirksam umgegliedert werden			Posten, die in späteren Perioden aufwands- oder ertragswirksam umgegliedert werden						
Neubewertung von leistungsorientierten Plänen	Latente Steuern	Fremdwährungsanpassungen	Absicherung künftiger Zahlungsströme	Marktwertänderungen der zur Veräußerung verfügbaren Wertpapiere	Latente Steuern				
-1.331	333	-2.425	-342	30	80	109.432	0	109.432	
						4.613		4.613	
-982	199	2.918	-144	-19	53	2.025		2.025	
-982	199	2.918	-144	-19	53	6.638	0	6.638	
-2.313	532	493	-486	11	133	116.070	0	116.070	
-2.313	532	493	-486	11	133	116.070	0	116.070	
						225		225	
-532	165	2.765	76	-11	-18	2.445		2.445	
-532	165	2.765	76	-11	-18	2.670	0	2.670	
-2.845	697	3.258	-410	0	115	118.740	0	118.740	

Entwicklung des Konzern-Anlagevermögens

Der Anlagespiegel ist Teil des Konzernanhangs.

Anlagespiegel 2015

in Tsd. €	Historische Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten				
	01.01.2015	Währungs- differenz	Zugang aus Investitionen	Umbuchungen / Umgliederungen	Abgang
I. Immaterielle Vermögenswerte					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	17.224	207	802		2
2. Entwicklungskosten	29.401	91	1		
3. Software	165	18			
4. Andere immaterielle Vermögenswerte	3.089	245			
	49.879	561	803	0	2
II. Geschäfts- oder Firmenwert					
	29.959	226			
III. Sachanlagen					
1. Grundstücke, Gebäude, Einbauten	16.922	140	510		959
2. Technische Anlagen und Maschinen	9.645	904	825		24
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.413	146	834		628
4. Fahrzeuge	421	6	10		63
5. Anlagen im Bau	2		430		
6. Aktivierte Leasinggegenstände					
Grundstücke, Gebäude, Einbauten	0				
Technische Anlagen und Maschinen	601	68			
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	18	3			
Fuhrpark	26	4			
	38.048	1.271	2.609	0	1.674
IV. Finanzanlagen					
Sonstige Finanzanlagen	2.120				
	2.120	0	0	0	0

Kumulierte Abschreibungen							Restbuchwerte		
31.12.2015	01.01.2015	Währungs- differenz	Zugang	Umbuchungen / Umgliederungen	Abgang	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2015	
18.231	14.492	133	819		2	15.442	2.732	2.789	
29.493	29.019	90	132			29.241	382	252	
183	165	18				183	0	0	
3.334	1.732	89	288			2.109	1.357	1.225	
51.241	45.408	330	1.239	0	2	46.975	4.471	4.266	
30.185	14.413					14.413	15.546	15.772	
16.613	2.537	99	763		959	2.440	14.385	14.173	
11.350	5.964	551	1.270		1	7.784	3.681	3.566	
10.765	8.332	103	887		617	8.705	2.081	2.060	
374	377	3	17		55	342	44	32	
432	0					0	2	432	
0	0					0	0	0	
669	601	68				669	0	0	
21	18	3				21	0	0	
30	21	2	7			30	5	0	
40.254	17.850	829	2.944	0	1.632	19.991	20.198	20.263	
2.120	2.120					2.120	0	0	
2.120	2.120	0	0	0	0	2.120	0	0	

Entwicklung des Konzern-Anlagevermögens

Der Anlagespiegel ist Teil des Konzernanhangs.

Anlagespiegel 2014

in Tsd. €	Historische Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten				
	01.01.2014	Währungs- differenz	Zugang aus Investitionen	Umbuchungen / Umgliederungen	Abgang
I. Immaterielle Vermögenswerte					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	16.729	178	1.145	0	828
2. Entwicklungskosten	29.360	91	45	0	95
3. Software	166	-1	0	0	0
4. Andere immaterielle Vermögenswerte	2.840	249	0	0	0
	49.095	517	1.190	0	923
II. Geschäfts- oder Firmenwert					
	29.731	228	0	0	0
III. Sachanlagen					
1. Grundstücke, Gebäude, Einbauten	16.482	112	447	37	156
2. Technische Anlagen und Maschinen	8.767	313	569	0	4
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.887	85	734	14	307
4. Fahrzeuge	400	7	14	0	0
5. Anlagen im Bau	52	0	2	-52	0
6. Aktivierte Leasinggegenstände					
Grundstücke, Gebäude, Einbauten	0	0	0	0	0
Technische Anlagen und Maschinen	610	43	0	0	52
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	18	0	0	0	0
Fuhrpark	26	0	0	0	0
	36.242	560	1.766	-1	519
IV. Finanzanlagen					
Sonstige Finanzanlagen	2.263	0	0	0	143
	2.263	0	0	0	143

Kumulierte Abschreibungen							Restbuchwerte		
31.12.2014	01.01.2014	Währungs- differenz	Zugang	Umbuchungen / Umgliederungen	Abgang	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2014	
17.224	14.431	88	801	0	828	14.492	2.298	2.732	
29.401	28.567	91	456	0	95	29.019	793	382	
165	166	-1	0	0	0	165	0	0	
3.089	1.414	60	258	0	0	1.732	1.426	1.357	
49.879	44.578	238	1.515	0	923	45.408	4.517	4.471	
29.959	14.413	0	0	0	0	14.413	15.318	15.546	
16.922	2.019	57	617	0	156	2.537	14.463	14.385	
9.645	4.659	132	1.176	0	3	5.964	4.108	3.681	
10.413	7.660	57	917	0	302	8.332	2.227	2.081	
421	359	4	14	0	0	377	41	44	
2	0	0	0	0	0	0	52	2	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
601	607	43	3	0	52	601	3	0	
18	18	0	0	0	0	18	0	0	
26	14	0	7	0	0	21	12	5	
38.048	15.336	293	2.734	0	513	17.850	20.906	20.198	
2.120	2.263	0	0	0	143	2.120	0	0	
2.120	2.263	0	0	0	143	2.120	0	0	

Segmentberichterstattung (IFRS)

Die Segmentberichterstattung ist Teil des Konzernanhangs.

Segmentinformationen nach Geschäftsfeldern

in Tsd. €	Lithografie		Substrat Bonder	
	2015	2014	2015	2014
Außenumsatz	106.299	96.719	11.389	22.436
Innenumsatz	0	0	0	0
Gesamter Umsatz	106.299	96.719	11.389	22.436
Segmentergebnis (EBIT)	9.683	10.661	-3.956	-2.435
Ergebnis vor Steuern	9.662	10.618	-3.958	-2.439
Wesentliche nicht zahlungswirksame Aufwendungen (-)/Erträge (+)	125	-1.169	521	2.851
Segmentvermögen	80.711	68.139	9.414	10.243
davon Geschäfts- oder Firmenwert	15.772	15.546	0	0
Nicht zugeordnetes Konzernvermögen				
Konzernaktiva				
Segmentschulden	-29.386	-17.801	-3.729	-2.435
Nicht zugeordnete Konzernschulden				
Konzernschulden				
Abschreibungen	1.808	1.979	300	349
davon planmäßig	1.808	1.979	300	349
davon außerplanmäßig	0	0	0	0
Investitionen	1.464	979	121	178
Mitarbeiter zum 31.12.	439	413	95	95

Segmentinformationen nach Regionen

in Tsd. €	Umsatzerlöse		Investitionen		Vermögen (ohne Goodwill)	
	2015	2014	2015	2014	2015	2014
EMEA	40.538	42.740	2.583	2.708	78.339	76.649
Nordamerika	27.962	21.472	760	196	22.182	16.829
Japan	7.045	10.171	0	8	2.628	955
Sonstiges Asien	72.971	70.948	69	44	3.474	2.788
Konsolidierungseffekte	0	0	0	0	-281	-278
Gesamt	148.516	145.331	3.412	2.956	106.342	96.943

<i>Fotomasken Equipment</i>		<i>Sonstige</i>		<i>Konsolidierungseffekte</i>		<i>Summe</i>	
<i>2015</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2014</i>
23.498	20.763	7.330	5.413	–	–	148.516	145.331
0	0	6.251	4.979	-6.251	-4.979	0	0
23.498	20.763	13.581	10.392	-6.251	-4.979	148.516	145.331
2.319	4.707	-3.073	-4.537	–	–	4.973	8.396
2.314	4.702	-3.313	-4.681	–	–	4.705	8.200
-42	415	-224	-1.190	–	–	380	907
9.420	12.673	22.569	21.434	–	–	122.114	112.489
0	0	0	0	–	–	15.772	15.546
						55.092	55.475
						177.206	167.964
-2.576	-8.974	-2.645	-2.142	–	–	-38.336	-31.352
						-20.130	-20.542
						-58.466	-51.894
207	168	1.868	1.753	–	–	4.183	4.249
207	168	1.868	1.753	–	–	4.183	4.249
0	0	0	0	–	–	0	0
93	269	1.734	1.530	–	–	3.412	2.956
103	97	61	54	–	–	698	659

Anhang zum IFRS-Konzernabschluss

der SÜSS MicroTec AG für das Geschäftsjahr 2015

(1) Beschreibung der Geschäftstätigkeit

Die SÜSS MicroTec AG (das „Unternehmen“ oder die „Gesellschaft“) mit Sitz in D-85748 Garching, Schleißheimer Str. 90, und ihre Tochtergesellschaften bilden einen international tätigen Konzern, der Produkte im Bereich der Mikrosystemtechnik und der Mikroelektronik fertigt und vertreibt. Die Produktion konzentriert sich auf die Standorte Garching und Sternenfels in Deutschland sowie Corona in den USA und Hauterive (Kanton Neuchâtel) in der Schweiz. Vertrieben werden die Produkte sowohl über die Produktionsstandorte selbst als auch zusätzlich über selbstständige Vertriebsgesellschaften in den USA, in Frankreich, Großbritannien, Japan, Singapur, Taiwan, China und Korea. In den Ländern, in denen der Konzern nicht selbst vertreten ist, wird der Vertrieb über Handelsvertretungen abgewickelt.

(2) Zusammenfassung der wesentlichen Rechnungslegungsgrundsätze

A) GRUNDLAGE DER DARSTELLUNG

Der vorliegende Konzernabschluss wurde nach den vom International Accounting Standards Board (IASB) verabschiedeten und veröffentlichten International Financial Reporting Standards (IFRS) sowie den zugehörigen Interpretationen des IFRS Interpretations Committee (IFRIC) aufgestellt, wie sie in der Europäischen Union verpflichtend anzuwenden sind. Die Anforderungen der IFRS wurden vollständig erfüllt und führen zur Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des SÜSS MicroTec-Konzerns.

Die Gesellschaft ist eine Aktiengesellschaft nach deutschem Recht. Nach den Regelungen des Handelsgesetzbuches muss die Gesellschaft einen Konzernabschluss nach den Rechnungslegungsvorschriften des § 315a HGB aufstellen, da es sich bei der SÜSS MicroTec AG um ein kapitalmarktorientiertes Unternehmen handelt. Der Konzernlagebericht wurde nach den Vorschriften des § 315 HGB erstellt.

Der Konzernabschluss und der Konzernlagebericht zum 31. Dezember 2015 werden beim elektronischen Bundesanzeiger eingereicht und veröffentlicht.

B) ERSTMALIG ANGEWANDTE STANDARDS UND INTERPRETATIONEN

Die SÜSS MicroTec AG wendete im Konzernabschluss zum 31. Dezember 2015 IFRIC 21 „Abgaben“ erstmals an. Auch die Änderungen, die sich aus den jährlichen Verbesserungen der IFRS – Zyklus 2011 bis 2013 ergaben, wurden erstmals angewandt.

Aus der erstmaligen Anwendung der genannten Standards haben sich keine Auswirkungen auf den Konzernabschluss ergeben.

C) NICHT VORZEITIG ANGEWANDTE STANDARDS UND INTERPRETATIONEN

Das IASB hat die nachfolgend dargestellten Standards und Änderungen zu Standards herausgegeben, deren Anwendung noch die Übernahme in EU-Recht („Endorsement“) erfordert:

IFRS 9: „Financial Instruments“

Im November 2009 veröffentlichte das IASB eine erste Fassung des neuen Standard IFRS 9 „Financial Instruments“ zur Klassifizierung und Bewertung von finanziellen Vermögenswerten. Nach mehreren Überarbeitungen und Änderungen hat das IASB die finale Fassung des Standards am 24. Juli 2014 veröffentlicht.

IFRS 9 „Financial Instruments“ enthält Vorschriften für den Ansatz, die Bewertung und Ausbuchung von Finanzinstrumenten sowie für die Bilanzierung von Sicherungsbeziehungen. Die bisher unter IAS 39 „Financial Instruments: Recognition and Measurement“ vorgenommene Bilanzierung von Finanzinstrumenten kann nun vollständig durch die Bilanzierung unter IFRS 9 ersetzt werden.

Die zentralen Anforderungen des finalen IFRS 9 lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- Die Regelungen von IFRS 9 sehen im Vergleich zu IAS 39 ein neues Klassifizierungsmodell für finanzielle Vermögenswerte vor. Die Folgebewertung finanzieller Vermögenswerte richtet sich künftig nach drei Kategorien mit unterschiedlichen Wertmaßstäben und einer unterschiedlichen Erfassung von Wertänderungen.
- Für finanzielle Verbindlichkeiten wurden die bestehenden Vorschriften des IAS 39 weitgehend unverändert in IFRS 9 übernommen. Die einzig wesentliche Neuerung betrifft finanzielle Verbindlichkeiten in der Fair-Value-Option.

- IFRS 9 sieht drei Stufen vor, welche die Höhe der zu erfassenden Verluste und die Zinsvereinnahmung künftig bestimmen.
- Neben umfangreichen Übergangsvorschriften ist IFRS 9 auch mit umfangreichen Offenlegungsvorschriften sowohl bei Übergang als auch in der laufenden Anwendung verbunden.

Der neue IFRS 9 wird voraussichtlich für alle Geschäftsjahre anzuwenden sein, die am oder nach dem 1. Januar 2018 beginnen.

Die SÜSS MicroTec AG kann derzeit noch nicht abschließend beurteilen, welche Auswirkungen die Erstanwendung des Standards haben wird, sofern der Standard verabschiedet und von der EU in dieser Form übernommen wird.

IFRS 15: „Revenue from Contracts with Customers“

Am 28. Mai 2014 veröffentlichte das IASB den neuen IFRS 15 „Revenue from Contracts with Customers“, der vorschreibt, wann und in welcher Höhe Erlöse zu erfassen sind. Der neue Standard fordert zudem zusätzliche informative Angaben zu Verträgen mit Kunden. IFRS 15 ist grundsätzlich auf alle Verträge mit Kunden anzuwenden. Eine Ausnahme bilden die folgenden Verträge:

- Leasingverhältnisse, die unter IAS 17 fallen;
- Finanzinstrumente und andere vertragliche Rechte und Pflichten, die unter IFRS 9, IFRS 10, IFRS 11, IAS 27 oder IAS 28 fallen;
- Versicherungsverträge im Anwendungsbereich von IFRS 4; und
- nicht-finanzielle Tauschgeschäfte zwischen Unternehmen derselben Branche, die darauf abzielen, Veräußerungen an Kunden oder potenzielle Kunden zu erleichtern.

Der neue Standard sieht im Gegensatz zu den aktuell gültigen Vorschriften ein einziges, prinzipienbasiertes fünfstufiges Modell vor, das auf alle Verträge mit Kunden anzuwenden ist.

Am 11. September 2015 veröffentlichte das IASB eine Änderung des IFRS 15, mit der sich der Erstanwendungszeitpunkt um ein Jahr auf den 1. Januar 2018 verschiebt. Damit sind die neuen Regelungen zur Umsatzlegung nun für Geschäftsjahre anzuwenden, die am oder nach dem 1. Januar 2018 beginnen.

Die SÜSS MicroTec AG kann derzeit noch nicht abschließend beurteilen, welche Auswirkungen die Erstanwendung des Standards haben wird, sofern der Standard verabschiedet und von der EU in dieser Form übernommen wird.

Die nachfolgend dargestellten neuen und geänderten Standards wurden bereits von der EU-Kommission in EU-Recht übernommen, sind jedoch im Geschäftsjahr 2015 noch nicht verpflichtend

anzuwenden. Eine Anwendung der neuen und geänderten Standards ist ab den obligatorischen Erstanwendungszeitpunkten vorgesehen. Von einer vorzeitigen Anwendung der neuen und geänderten Standards wurde kein Gebrauch gemacht.

IFRS 11: „Joint Arrangements“

Am 6. Mai 2014 veröffentlichte das IASB Änderungen zum IFRS 11 „Joint Arrangements“ hinsichtlich der Bilanzierung eines Erwerbs von Anteilen an einer gemeinschaftlichen Tätigkeit, die einen Geschäftsbetrieb in Sinne des IFRS 3 „Unternehmenszusammenschlüsse“ darstellt. In solchen Fällen soll der Erwerber die Grundsätze für die Bilanzierung von Unternehmenszusammenschlüssen nach IFRS 3 anwenden. Zudem greifen auch in diesen Fällen die Angabepflichten des IFRS 3.

Im Amtsblatt der Europäischen Union vom 25. November 2015 wurde die Verordnung Nr. 2015/2173 bekannt gemacht, mit der die vom IASB veröffentlichten Änderungen an IFRS 11 übernommen wurden.

Die Änderungen sind für Geschäftsjahre anzuwenden, die am oder nach dem 1. Januar 2016 beginnen. Eine frühere Anwendung ist zulässig.

Die SÜSS MicroTec AG erwartet aus der erstmaligen Anwendung der Änderungen keine Auswirkungen.

IAS 16 „Property, Plant and Equipment“ und IAS 38 „Intangible Assets“

Am 12. Mai 2014 hat das IASB Änderungen an IAS 16 „Property, Plant and Equipment“ sowie an IAS 38 „Intangible Assets“ veröffentlicht. Mit den Änderungen wird klargestellt, dass umsatzbasierte Abschreibungsmethoden für Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte grundsätzlich nicht sachgerecht sind.

Im Amtsblatt der Europäischen Union vom 3. Dezember 2015 wurde die Verordnung Nr. 2015/2231 bekannt gemacht, mit der die vom IASB veröffentlichten Änderungen an den beiden Standards übernommen wurden.

Die Änderungen sind für Geschäftsjahre anzuwenden, die am oder nach dem 1. Januar 2016 beginnen.

Die SÜSS MicroTec AG erwartet aus der erstmaligen Anwendung der Änderungen keine Auswirkungen.

Amendments to IAS 1 – „Disclosure Initiative“

Am 18. Dezember 2014 hat das IASB im Rahmen der „Disclosure Initiative“ Änderungen an IAS 1 veröffentlicht, die hinsichtlich der in IAS 1 geregelten Angabepflichten eine zu restriktive Auslegung des Standards verhindern und sachgerechte Ermessensentscheidungen ermöglichen sollen.

Im Amtsblatt der Europäischen Union vom 19. Dezember 2015 wurde die Verordnung Nr. 2015/2406 bekannt gemacht, mit der die vom IASB veröffentlichten Änderungen an IAS 1 übernommen wurden.

Die Änderungen sind für Geschäftsjahre anzuwenden, die am oder nach dem 1. Januar 2016 beginnen.

Die SÜSS MicroTec AG erwartet aus der erstmaligen Anwendung der Änderungen keine Auswirkungen.

Jährliche Verbesserungen der IFRS – Zyklus 2012 bis 2014

Am 25. September 2014 veröffentlichte das IASB jährliche Verbesserungen der IFRS – Zyklus 2012 bis 2014. Die Änderungen betreffen Klarstellungen zu IFRS 5, IFRS 7, IAS 19 und IAS 34.

Im Amtsblatt der Europäischen Union vom 16. Dezember 2015 wurde die Verordnung Nr. 2015/2343 bekannt gemacht, mit der die vom IASB veröffentlichten Änderungen an den genannten Standards übernommen wurden.

Die Änderungen sind verpflichtend anzuwenden auf Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2016 beginnen.

Die SÜSS MicroTec AG erwartet aus der erstmaligen Anwendung der Änderungen keine Auswirkungen.

IAS 19 „Employee Benefits“

Am 21. November 2013 veröffentlichte das IASB Änderungen an IAS 19 „Employee Benefits“, mit denen klargestellt wird, wie Arbeitnehmerbeiträge oder Beiträge Dritter zu leistungsorientierten Plänen zu bilanzieren sind.

Im Amtsblatt der Europäischen Union vom 17. Dezember 2014 wurde die Verordnung Nr. 2015/29 bekannt gemacht, mit der die vom IASB veröffentlichten Änderungen an IAS 19 übernommen wurden.

Der geänderte IAS 19 ist verpflichtend anzuwenden auf Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Februar 2015 beginnen.

Die SÜSS MicroTec AG erwartet aus der erstmaligen Anwendung keine Auswirkungen.

Jährliche Verbesserungen der IFRS – Zyklus 2010 bis 2012

Am 12. Dezember 2013 veröffentlichte das IASB jährliche Verbesserungen der IFRS – Zyklus 2010 bis 2012.

Im Amtsblatt der Europäischen Union vom 17. Dezember 2014 wurde die Verordnung Nr. 2015/28 bekannt gemacht, mit der die vom IASB veröffentlichten jährlichen Verbesserungen übernommen wurden.

Die Änderungen sind verpflichtend anzuwenden auf Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Februar 2015 beginnen.

Die SÜSS MicroTec AG erwartet aus der erstmaligen Anwendung keine Auswirkungen.

D) WESENTLICHE BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Der Konzernabschluss erfüllt unter Beachtung der qualitativen Kriterien der Rechnungslegung sowie der anzuwendenden IFRS den Grundsatz des True and fair Views sowie der Fair Presentation. Bei der Erstellung des IFRS-Konzernabschlusses wurden im Wesentlichen die folgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden unverändert gegenüber Vorjahr angewendet.

Geschäfts- oder Firmenwert

Nach IFRS 3 wird der derivative Geschäfts- oder Firmenwert nicht planmäßig abgeschrieben, sondern wird einmal jährlich auf Wertminderung überprüft. Eine Überprüfung erfolgt auch, wenn Ereignisse oder Umstände (Triggering Events) eintreten, die auf eine mögliche Wertminderung hindeuten.

Die Überprüfung der Werthaltigkeit des Goodwills erfolgt auf der Ebene zahlungsmittelgenerierender Einheiten (Cash Generating Units), die im SÜSS MicroTec-Konzern den operativen Segmenten entsprechen.

Eine Wertminderung wird vorgenommen, sofern die Buchwerte der Vermögenswerte nicht mehr durch den erzielbaren Betrag der jeweiligen Cash Generating Unit gedeckt sind. Der erzielbare Betrag ist der höhere der beiden Beträge aus beizulegendem Zeitwert abzüglich Verkaufskosten und Nutzungswert. Die SÜSS MicroTec AG hat im Berichtsjahr den erzielbaren Betrag der zahlungsmittelgenerierenden Einheiten auf der Basis des Nutzungswertes errechnet. Dieser Wert beruht grundsätzlich auf Bewertungen mittels diskontierter Mittelzuflüsse.

Sonstige immaterielle Vermögenswerte

Erworbene und selbst geschaffene immaterielle Vermögenswerte werden gemäß IAS 38 aktiviert, wenn es wahrscheinlich ist, dass mit der Nutzung des Vermögenswertes ein zukünftiger wirtschaftlicher Vorteil verbunden ist und die Kosten des Vermögenswertes zuverlässig bestimmt werden können. Sie werden zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten angesetzt und planmäßig linear über ihre jeweilige Nutzungsdauer, die maximal zehn Jahre beträgt, abgeschrieben.

Entwicklungskosten im Rahmen der Produktentwicklung werden zu Herstellungskosten aktiviert, soweit eine eindeutige Aufwandszuordnung möglich und sowohl technische Realisierbarkeit als auch erfolgreiche Vermarktung sichergestellt ist. Die Entwicklungstätigkeit muss ferner mit hinreichender Wahrscheinlichkeit einen künftigen wirtschaftlichen Nutzen erzeugen. Die aktivierten Entwicklungsleistungen umfassen alle direkt dem Entwicklungsprozess zurechenbaren Kosten einschließlich entwicklungsbezogener Gemeinkosten. Aktivierter Entwicklungskosten werden ab Produktionsstart planmäßig linear über den erwarteten Produktlebenszyklus von in der Regel drei bis fünf Jahren abgeschrieben.

Sonstige immaterielle Vermögenswerte mit einer unbestimmten Nutzungsdauer liegen in der SÜSS MicroTec-Gruppe nicht vor.

Sachanlagen

Die Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bilanziert und nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer um planmäßige lineare Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungsdauern für die wesentlichen Anlagekategorien sind nachstehend wiedergegeben:

Gebäude, Einbauten	10–40 Jahre
Technische Anlagen und Maschinen	4–5 Jahre
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3–5 Jahre
Fahrzeuge	5 Jahre

Bei Anlagenabgängen werden die zugehörigen historischen Anschaffungskosten und kumulierten Abschreibungen ausgebucht und die Differenz zum Verkaufserlös als sonstiger betrieblicher Aufwand oder Ertrag erfasst.

Bei gemieteten Anlagegegenständen wird gemäß IAS 17 zwischen „Finance Lease“ und „Operating Lease“ unterschieden. Gegenstände des „Finance Lease“ werden unter Ansatz des Barwertes aller künftigen Mindestleasingzahlungen bei gleichzeitiger Passivierung der Leasingschuld aktiviert. Die aktivierten Gegenstände werden über ihre maßgebliche Nutzungsdauer abgeschrieben, die Leasingschuld wird gemäß den vertraglichen

Bedingungen des Leasingvertrages getilgt und verzinst. Beim „Operating Lease“ erfolgt keine Aktivierung, sondern eine Erfassung der periodisierten Leasingzahlungen im Aufwand.

Eine Neubewertung der Sachanlagen gemäß den Regelungen des IAS 16 erfolgte nicht.

Wertminderungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen

Eine Wertminderung auf immaterielle Vermögenswerte einschließlich des Geschäfts- oder Firmenwerts sowie auf Sachanlagen wird vorgenommen, sofern die Buchwerte der Vermögenswerte nicht mehr durch die zu erwartenden Veräußerungserlöse bzw. die diskontierten Netto-Cashflows aus der weiteren Nutzung gedeckt sind. Ist die Ermittlung des erzielbaren Betrags für einzelne Vermögenswerte nicht möglich, wird der Cashflow für die nächsthöhere Gruppierung von Vermögenswerten bestimmt, für die ein derartiger Cashflow ermittelt werden kann. Die Zuordnung des Geschäfts- oder Firmenwerts erfolgt auf der Grundlage der Berichtseinheiten (Segmente).

Sofern in den Folgeperioden die Gründe für die Wertminderungen entfallen sind, werden Zuschreibungen vorgenommen. Die Zuschreibung erfolgt dabei höchstens auf den Betrag, der sich ohne die Vornahme der Wertminderung ergeben hätte. Eine Zuschreibung auf abgewertete Geschäfts- oder Firmenwerte erfolgt nicht.

Vorräte

Die Vorräte werden zu Herstellungs- bzw. Anschaffungskosten oder zum niedrigeren Nettoveräußerungswert bewertet. Der Nettoveräußerungswert stellt dabei den voraussichtlich erzielbaren Verkaufserlös abzüglich der bis zum Verkauf noch anfallenden Kosten dar. Zudem werden Bestandsrisiken des Vorratsvermögens, die sich aus geminderter Verwertbarkeit und technischen Risiken ergeben, durch angemessene Wertberichtigungen berücksichtigt.

Die Herstellungskosten der unfertigen bzw. fertigen Erzeugnisse beinhalten direkte Material- und Fertigungskosten sowie zurechenbare Material- und Fertigungsgemeinkosten.

Für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe erfolgt die Ermittlung der Anschaffungskosten auf der Grundlage eines gewichteten Durchschnittswertes.

Bei Wegfall der Gründe, die zu einer Wertberichtigung der Vorräte geführt haben, wird eine entsprechende Wertaufholung vorgenommen.

Finanzinstrumente

Finanzinstrumente sind Vertragsverhältnisse, die bei der einen Partei zu einem finanziellen Vermögenswert und bei der anderen Partei zu einer finanziellen Schuld oder zu einem Eigenkapitalinstrument führen. Diese werden in die Klassen „bewertet zu fortgeführten Anschaffungskosten“, „bewertet zu Marktwerten“ und in „Leasingverbindlichkeiten“ eingeteilt.

Das Unternehmen erfasst Finanzinstrumente in der Bilanz, sobald die SÜSS MicroTec-Gruppe Vertragspartner eines Finanzinstruments wird. Der erstmalige Ansatz erfolgt zum Marktwert. Die Folgebewertung finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten erfolgt entsprechend der Kategorie, der sie zugeordnet sind – den zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerten, den Krediten und Forderungen, den finanziellen Verbindlichkeiten oder den zu Handelszwecken gehaltenen finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten.

Die Kategorien „Held to Maturity“ sowie die „Fair Value Option“ werden nicht genutzt.

Forderungen und sonstige finanzielle Vermögenswerte

Forderungen und sonstige finanzielle Vermögenswerte werden mit Ausnahme der derivativen Finanzinstrumente der Kategorie „Kredite und Forderungen“ zugeordnet und zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet. Es erfolgen angemessene Wertberichtigungen bei zweifelhaften und als uneinbringlich betrachteten Forderungen. Darüber hinaus werden Wertberichtigungen in Abhängigkeit von der Altersstruktur überfälliger Forderungen gebildet. Diese Wertminderungen werden auf separaten Wertberichtigungskonten erfasst.

Wertpapiere

Wertpapiere werden als zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte klassifiziert, da sie nicht zu Spekulationszwecken gehalten werden. Sie werden zum beizulegenden Zeitwert bilanziert, sofern dieser verlässlich ermittelbar ist. Unrealisierte Gewinne und Verluste werden unter Berücksichtigung latenter Steuern im kumulierten übrigen Eigenkapital ausgewiesen.

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

Die Zahlungsmitteläquivalente umfassen alle liquiditätsnahen Vermögenswerte, die zum Zeitpunkt der Anschaffung bzw. der Anlage eine Restlaufzeit von weniger als drei Monate haben. Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente werden zu Anschaffungskosten bewertet.

Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Die Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen wird gemäß IAS 19 („Employee Benefits“) bilanziert.

Beitragsorientierte Pläne („Defined Contribution Plans“) führen in der Regel nicht zu einer Rückstellungsbildung, da sich die Verpflichtung des Unternehmens auf die Zahlung von Beiträgen an den Versorgungsträger/Fonds beschränkt. Die Prämienzahlungen an die Versorgungsträger/Fonds werden in der Periode ihres Anfalls als Aufwand erfasst.

Bei leistungsorientierten Plänen („Defined Benefit Plans“) besteht die Verpflichtung des Unternehmens in der Gewährung der zugesagten Leistungen an aktive und frühere Arbeitnehmer. Leistungsorientierte Pläne führen in der Regel zur Bildung von Pensionsrückstellungen.

Die Nettoschuld aus leistungsorientierten Versorgungsplänen (Barwert der leistungsorientierten Verpflichtung abzüglich bewertetem Planvermögen) wird mittels des Anwartschaftsbarwertverfahrens („Projected Unit Credit Method“) berechnet. Zukünftige Gehaltssteigerungen und sonstige Erhöhungen der Leistungen werden berücksichtigt. Die Bewertung der Pensionsverpflichtungen erfolgt auf Basis von Pensionsgutachten unter Einbeziehung der zur Deckung dieser Verpflichtungen bestehenden Vermögenswerte (zum beizulegenden Zeitwert bewertetes Planvermögen). Die Effekte aus der Neubewertung der Nettoschuld (versicherungsmathematische Gewinne und Verluste, Erträge aus dem Planvermögen sowie die Veränderungen in der Auswirkung der Vermögensobergrenze) werden in voller Höhe im kumulierten übrigen Eigenkapital erfasst. Im Fall künftiger Planänderungen wird der nachzuverrechnende Dienstzeitaufwand sofort ergebniswirksam erfasst.

Rückstellungen

Rückstellungen werden gemäß IAS 37 gebildet, wenn eine Verpflichtung gegenüber Dritten besteht, deren Inanspruchnahme wahrscheinlich und die voraussichtliche Höhe des notwendigen Rückstellungsbetrages zuverlässig schätzbar ist. Die Bewertung erfolgt zu Vollkosten. Langfristige Rückstellungen werden auf Grundlage angemessener Zinssätze mit ihrem auf den Bilanzstichtag abgezinsten Erfüllungsbetrag angesetzt.

Finanzschulden

Die Finanzschulden umfassen die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und Verbindlichkeiten aus dem Finanzierungsleasing. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten werden der Kategorie „finanzielle Verbindlichkeiten“ zugeordnet und zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet. Die Verbindlichkeiten aus dem Finanzierungsleasing, die der Klasse „Leasingverbindlichkeiten“ zugeordnet sind, werden gemäß IAS 17 bewertet.

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten werden mit Ausnahme der derivativen Finanzinstrumente der Kategorie „finanzielle Verbindlichkeiten“ zugeordnet und zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen werden der Kategorie „finanzielle Verbindlichkeiten“ zugeordnet und zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet.

Leasing

Die Feststellung, ob eine Vereinbarung ein Leasingverhältnis enthält, wird auf Basis des wirtschaftlichen Gehalts der Vereinbarung zum Zeitpunkt des Abschlusses der Vereinbarung getroffen und erfordert eine Einschätzung, ob die Erfüllung der vertraglichen Vereinbarung von der Nutzung eines bestimmten Vermögenswerts oder bestimmter Vermögenswerte abhängig ist und ob die Vereinbarung ein Recht auf die Nutzung des Vermögenswerts einräumt, selbst wenn dieses Recht in einer Vereinbarung nicht ausdrücklich festgelegt ist.

Bei Leasingvereinbarungen, die vor dem 1. Januar 2005 abgeschlossen wurden, gilt in Übereinstimmung mit den Übergangsvorschriften von IFRIC 4 der 1. Januar 2005 als Zeitpunkt des Abschlusses der Leasingvereinbarung.

Finanzierungs-Leasingverhältnisse, bei denen im Wesentlichen alle mit dem Eigentum verbundenen Chancen und Risiken am Leasinggegenstand auf den Konzern übertragen werden, führen zur Aktivierung des Leasinggegenstands zu Beginn der Laufzeit des Leasingverhältnisses. Der Leasinggegenstand wird mit seinem beizulegenden Zeitwert angesetzt oder mit dem Barwert der Mindestleasingzahlungen, sofern dieser Wert niedriger ist. Leasingzahlungen werden derart in Finanzierungsaufwendungen und den Tilgungsanteil der Restschuld aufgeteilt, dass sich über die Laufzeit des Leasingverhältnisses ein konstanter Zinssatz auf die verbliebene Leasingverbindlichkeit ergibt. Finanzierungsaufwendungen werden erfolgswirksam erfasst.

Leasinggegenstände werden über die Nutzungsdauer des Gegenstands beschrieben. Ist der Eigentumsübergang auf den Konzern am Ende der Laufzeit des Leasingverhältnisses jedoch nicht hinreichend sicher, wird der Leasinggegenstand über den kürzeren der beiden Zeiträume aus erwarteter Nutzungsdauer und Laufzeit des Leasingverhältnisses vollständig beschrieben. Leasingzahlungen für Operating-Leasingverhältnisse werden linear über die Laufzeit des Leasingverhältnisses als Aufwand für Operating-Leasingverhältnisse in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst.

Nicht fortgeführte Aktivitäten

Nicht fortgeführte Aktivitäten werden ausgewiesen, sobald ein Unternehmensbestandteil mit Geschäftsaktivitäten und Cashflows, die operativ und für Zwecke der Rechnungslegung vom restlichen Unternehmen klar abgegrenzt werden können, als zur Veräußerung klassifiziert wird oder bereits abgegangen ist, und der Geschäftsbereich einen gesonderten wesentlichen Geschäftszweig darstellt.

Umsatzrealisierung

Umsatzerlöse aus Maschinenverkäufen werden gemäß IAS 18 erfasst, wenn die Voraussetzungen zur Umsatzrealisierung erfüllt sind. Umsatzerlöse werden zum Zeitpunkt der Übertragung der maßgeblich mit dem Eigentum der verkauften Ware verbundenen Risiken und Chancen auf den Käufer realisiert, wenn es hinreichend wahrscheinlich ist, dass der Gesellschaft der wirtschaftliche Nutzen aus dem Verkauf zufließen wird. Die Höhe der erfassten Umsatzerlöse basiert auf den beizulegenden Zeitwerten der zu erhaltenen oder zu beanspruchenden Gegenleistung.

Kundenaufträge der Gesellschaft beinhalten in der Regel Installationsleistungen, die notwendig sind, um die verkaufte Maschine in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen. Aufgrund der Komplexität der Installationsvorgänge geht die Gesellschaft davon aus, dass signifikante Eigentumsrisiken bis zum Abschluss der Installation beim Unternehmen verbleiben. Daher wird bei Verträgen, bei denen neben der Lieferung einer Maschine auch die Installation und die Endabnahme mit dem Kunden vereinbart ist, der Umsatz erst realisiert, wenn Aufstellung und Montage erbracht sind, und die Endabnahme durch den Kunden erfolgt ist.

Umsätze aus Serviceleistungen werden bei erbrachter Leistung oder, bei vorhandenen Serviceverträgen, zeitanteilig realisiert. Im Fall von Ersatzteilverkäufen wird der Umsatz bei Lieferung realisiert.

Umsatzkosten

Die Umsatzkosten umfassen die den Umsatzerlösen zuzuordnenden Herstellungs- und Beschaffungskosten der verkauften Erzeugnisse und Ersatzteile. Sie beinhalten neben den direkt zurechenbaren Material- und Fertigungseinzelkosten auch Gemeinkosten einschließlich der Abschreibungen auf die Produktionsanlagen und die immateriellen Vermögenswerte sowie die Abwertungen auf die Vorräte.

Forschungs- und Entwicklungskosten

Aufwendungen für Forschung und nicht aktivierungsfähige Entwicklungen werden bei Entstehung als Aufwand erfasst.

Sonstige betriebliche Aufwendungen und Erträge

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen und Erträge werden dem operativen Ergebnis zugeordnet und periodengerecht erfasst. Dies betrifft auch die Aufwendungen und Erträge aus der Fremdwährungsumrechnung.

Latente Steuern

Latente Steueransprüche und -verbindlichkeiten werden entsprechend IAS 12 („Income Taxes“) für alle temporären Differenzen zwischen den steuerlichen Bemessungsgrundlagen der Vermögenswerte und Schulden und deren Wertansätzen in der IFRS-Konzernbilanz sowie auf steuerliche Verlustvorträge gebildet. Die latenten Steuern werden auf Basis der Steuersätze ermittelt, die nach der derzeitigen Rechtslage in den einzelnen Ländern zum Realisationszeitpunkt gelten bzw. erwartet werden. Latente Steueransprüche auf temporäre Differenzen bzw. Verlustvorträge werden nur dann angesetzt, sofern ihre Realisierbarkeit in näherer Zukunft hinreichend gesichert erscheint.

Auf temporäre Unterschiede beim Geschäfts- oder Firmenwert werden latente Steuern nur dann angesetzt, wenn die Abschreibungen auf derivative Geschäfts- oder Firmenwerte steuerlich geltend gemacht werden können.

Ergebnis pro Aktie (EPS – Earnings per Share)

Die Gesellschaft berechnet das Ergebnis pro Aktie nach IAS 33 („Earnings per Share“).

Das unverwässerte Ergebnis pro Aktie (EPS) wird berechnet, indem das Jahresergebnis durch den gewichteten Durchschnitt der ausgegebenen Aktien dividiert wird.

Das verwässerte Ergebnis pro Aktie wird ermittelt, indem das bereinigte Jahresergebnis durch den gewichteten Durchschnitt der ausgegebenen Aktien zuzüglich der zu einer Verwässerung führenden Aktienäquivalente dividiert wird.

Derivative Finanzinstrumente

Zur Absicherung von Währungs- und Zinsrisiken werden in der SÜSS MicroTec-Gruppe derivative Finanzinstrumente abgeschlossen.

Die Bilanzierung der derivativen Finanzinstrumente erfolgt gemäß IAS 39. Derivative Finanzinstrumente werden den zu Handelszwecken gehaltenen finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten zugeordnet, zum Marktwert bilanziert und unter den sonstigen kurzfristigen finanziellen Vermögenswerten bzw. sonstigen kurzfristigen finanziellen Verbindlichkeiten ausgewiesen. Der erstmalige Ansatz erfolgt zum Handelstag. Marktwertänderungen

werden entweder in der Gewinn- und Verlustrechnung oder, sofern es sich um einen Cashflow Hedge handelt, nach der Berücksichtigung von latenten Steuern im kumulierten übrigen Eigenkapital ausgewiesen.

Cashflow Hedges

Der effektive Teil der Marktwertänderungen derivativer Instrumente, die als Cashflow Hedges bestimmt sind, wird nach Berücksichtigung von latenten Steuern im kumulierten übrigen Eigenkapital erfasst. Der ineffektive Teil wird sofort erfolgswirksam in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst.

Bilanzierung von Zuschüssen

Zuwendungen aus der öffentlichen Hand werden gemäß IAS 20 („Accounting for Government Grants“) nur erfasst, wenn eine angemessene Sicherheit dafür besteht, dass die damit verbundenen Bedingungen erfüllt und die Zuwendungen gewährt werden. Sie werden erfolgswirksam behandelt und grundsätzlich in den Perioden verrechnet, in denen die Aufwendungen anfallen, die durch die Zuwendungen kompensiert werden sollen. Zuschüsse, die sich auf aktivierungsfähige Entwicklungskosten beziehen, werden von diesen abgesetzt.

Transaktionen in Fremdwährung

Einkäufe und Verkäufe in Fremdwährungen werden mit dem zum Zeitpunkt der Lieferung geltenden Tageskurs umgerechnet. Vermögenswerte und Schulden in Fremdwährung werden mit dem geltenden Währungskurs am Bilanzstichtag in die funktionale Währung umgerechnet. Die aus diesen Umrechnungen entstandenen Fremdwährungsgewinne und -verluste werden ergebniswirksam erfasst.

E) VERWENDUNG VON SCHÄTZUNGEN

Die Aufstellung eines Konzernabschlusses nach den IFRS verlangt Einschätzungen und Annahmen, die Einfluss auf den Ausweis von Vermögenswerten und Schulden, die Angabe von Eventualverbindlichkeiten zum Bilanzstichtag sowie den Ausweis von Erträgen und Aufwendungen haben. Die tatsächlichen Werte können in Einzelfällen von den getroffenen Annahmen und Schätzungen abweichen.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Wertberichtigung zweifelhafter Forderungen umfasst in erheblichem Maß Einschätzungen und Beurteilungen einzelner Forderungen, die auf der Kreditwürdigkeit des jeweiligen Kunden, den aktuellen Konjunktorentwicklungen und der Analyse historischer Forderungsausfälle auf Portfoliobasis beruhen. Soweit das Unternehmen die Wertberichtigung aus historischen Ausfallraten auf Portfoliobasis ableitet, vermindert ein Rückgang

des Forderungsvolumens solche Vorsorgen entsprechend und umgekehrt. Zum 31. Dezember 2015 betrug die gesamte Wertberichtigung auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 471 Tsd. € (Vorjahr: 323 Tsd. €).

Wertminderungen

Die SÜSS MicroTec AG überprüft den Geschäfts- oder Firmenwert mindestens einmal jährlich auf mögliche Wertminderung. Die Bestimmung des erzielbaren Betrags einer Cash Generating Unit, der der Geschäfts- oder Firmenwert zugeordnet wurde, ist mit Schätzungen des Managements verbunden. Der erzielbare Betrag ist der höhere Wert aus dem beizulegenden Zeitwert, abzüglich der Verkaufskosten, und dem Nutzungswert. Die Gesellschaft bestimmt diese Werte grundsätzlich mit Bewertungsmethoden, die auf diskontierten Cashflows basieren. Diese diskontierten Cashflows werden für einen Fünf-Jahres-Zeitraum ermittelt. Dabei werden für die unmittelbare Zukunft die aus der Konzernplanung abgeleiteten Cashflows zugrunde gelegt. Für die über die Detailplanungsperiode hinausgehenden Cashflow-Prognosen werden geeignete Forecasts aus der Halbleiterzulieferindustrie herangezogen. Auf Basis dieser Forecasts wird für jedes Jahr des Betrachtungszeitraums eine Wachstumsrate ermittelt. Für den Fünf-Jahres-Zeitraum errechnet sich für die Cash Generating Unit Lithografie, der der bilanzierte Geschäfts- oder Firmenwert zugeordnet ist, ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 9,0 % (Vorjahr: 8,8 %). Die Diskontierung der prognostizierten Netto-Cashflows wird unter Nutzung eines risikoadjustierten Zinssatzes in Höhe von 8,5 % (Vorjahr: 9,5 %) durchgeführt. Diese Prämissen sowie die zugrundeliegende Methodik können einen erheblichen Einfluss auf die jeweiligen Werte und letztlich auf die Höhe einer möglichen Wertminderung des Geschäfts- oder Firmenwerts haben.

Ist im Rahmen von Wertminderungstests bei Sachanlagen oder sonstigen immateriellen Vermögenswerten die Ermittlung des erzielbaren Betrags für einzelne Vermögenswerte nicht möglich, wird der Cashflow für die nächsthöhere Gruppierung von Vermögenswerten bestimmt, für die ein derartiger Cashflow ermittelt werden kann. Auch bei Sachanlagen oder sonstigen immateriellen Vermögenswerten ist die Bestimmung des erzielbaren Betrags der Vermögenswerte gleichermaßen mit Schätzungen des Managements verbunden, was einen erheblichen Einfluss auf die jeweiligen Werte und letztlich auf die Höhe einer möglichen Wertminderung haben kann.

Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Verpflichtungen für Pensionen und damit zusammenhängende Aufwendungen und Erträge werden in Übereinstimmung mit versicherungsmathematischen Bewertungen ermittelt. Diese

Bewertungen beruhen auf Schlüsselprämissen, darunter Abzinsungsfaktoren, die erwartete Rendite des Fondsvermögens, Gehaltstrends sowie Lebenserwartungen. Die angesetzten Abzinsungsfaktoren spiegeln die Zinssätze wider, die am Bilanzstichtag für hochwertige festverzinsliche Anlagen mit entsprechender Laufzeit erzielt werden.

Aufgrund schwankender Markt- und Wirtschaftslage können die zugrunde gelegten Prämissen von der tatsächlichen Entwicklung abweichen, was wesentliche Auswirkungen auf die Verpflichtungen für Pensionen haben kann.

Rückstellungen

Die Bestimmung von Rückstellungen für vertraglich vereinbarte Garantien und Gewährleistungsansprüche ist in erheblichem Maß mit Einschätzungen verbunden. Soweit das Unternehmen diese Rückstellungen aus historischen Garantie- und Gewährleistungsfällen ableitet, vermindert ein Rückgang des Umsatzvolumens solche Vorsorgen entsprechend und umgekehrt.

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten

Die sonstigen finanziellen Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag passiviert. Sie werden ausgebucht, wenn die vertraglichen Verpflichtungen erfüllt, aufgehoben oder ausgelaufen sind. Abhängig vom Inhalt der vertraglichen Vereinbarungen sind Schätzungen notwendig, um den wahrscheinlichen Erfüllungsbetrag zu bestimmen.

Purchase Price Allocation

Bei Unternehmenserwerben nach IAS 27 (rev. 2008) und IFRS 3 (rev. 2008) ist der Kaufpreis für den Unternehmenserwerb auf die beim Kauf erworbenen identifizierbaren Vermögenswerte, Schulden und Eventualschulden vorzunehmen. Vermögenswerte, Schulden und Eventualschulden sind mit einzelnen Ausnahmen (z. B. Steuerschulden, Pensionsverpflichtungen, anteilsbasierte Vergütungen) zum beizulegenden Zeitwert anzusetzen. Hierbei sind nicht nur bilanzierte Vermögenswerte zu berücksichtigen, sondern auch bislang nicht angesetzte immaterielle Vermögenswerte.

F) KONSOLIDIERUNG

Konsolidierungsgrundsätze

In den Konzernabschluss werden die Abschlüsse der SÜSS MicroTec AG und aller aktiven Gesellschaften, bei denen nach dem Control-Prinzip unabhängig von der Beteiligungshöhe die Beherrschungsmöglichkeit besteht, einbezogen. Bei einer Mehrheit der Stimmrechte wird grundsätzlich von der Kontrolle ausgegangen.

Forderungen und Verbindlichkeiten sowie Erträge und Aufwendungen zwischen den in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen werden ebenso wie die Zwischenergebnisse eliminiert.

Umrechnung von Jahresabschlüssen in fremder Währung

Die Darstellungswährung des Konzerns ist der Euro, die der funktionalen Währung der Muttergesellschaft entspricht. Alle Angaben erfolgen in Tausend Euro, sofern nichts anderes vermerkt ist.

Bilanzposten von Tochtergesellschaften, deren funktionale Währung die jeweilige lokale Währung ist, werden (mit Ausnahme des Eigenkapitals, das zu historischen Kursen umgerechnet wird) zum Kurs am Bilanzstichtag umgerechnet, die Posten der Gewinn- und Verlustrechnung zu Durchschnittskursen.

	2015		2014	
	Bilanz	G & V	Bilanz	G & V
1 EUR vs 1 USD	1,089	1,113	1,216	1,326
1 EUR vs 1 JPY	131,129	134,473	145,040	140,805
1 EUR vs 1 GBP	0,735	0,728	0,779	0,806
1 EUR vs 1 CHF	1,082	1,075	1,202	1,214
1 EUR vs 1 TWD	35,984	35,348	38,635	40,278
1 EUR vs 1 SGD	1,540	1,528	1,606	1,683
1 EUR vs 1 CNY	7,092	6,944	7,480	8,156
1 EUR vs 1 KRW	1.284,770	1.260,293	1.336,150	1.397,795

Die resultierenden Umrechnungsdifferenzen werden als separate Komponente des Eigenkapitals (kumuliertes übriges Eigenkapital) ausgewiesen.

Angaben zum Konsolidierungskreis

Im Vergleich zum Konzernabschluss zum 31. Dezember 2014 ergaben sich keine Veränderungen im Konsolidierungskreis.

In den Konzernabschluss zum 31. Dezember 2015 werden demzufolge folgende Tochterunternehmen und Beteiligungen der SÜSS MicroTec AG (Konzernobergesellschaft) einbezogen (Angaben zu Kapital und Jahresergebnis der einzelnen Gesellschaften gemäß lokalem Recht und in lokaler Währung).

Gesellschaft / Sitz	Währung	gezeichnetes Kapital	Beteiligung	Eigenkapital	Jahresergebnis	Konsolidierung
SÜSS MicroTec AG, Garching ¹	EUR	19.115.538,00	Holding	78.227.376,09	-17.912.043,36	voll
SUSS MicroTec Lithography GmbH, Garching ²	EUR	2.000.100,00	100 %	46.986.087,76	6.259.611,51	voll
SUSS MicroTec Photomask Equipment GmbH & Co. KG, Sternenfels	EUR	3.000.000,00	100 %	3.000.000,00	1.786.433,91	voll
SUSS MicroTec Photomask Equipment Beteiligungs GmbH, Sternenfels	EUR	25.000,00	100 %	14.163,50	-167,71	voll
SUSS MicroTec Ltd., Market Rasen, Großbritannien	GBP	10.000,00	100 %	1.199.411,99	-7.972,91	voll
SUSS MicroTec KK, Yokohama, Japan	JPY	30.000.000,00	100 %	-693.261.793,00	-104.031.194,00	voll
SUSS MicroTec S.a.r.l., Pierre Bénite, Frankreich	EUR	114.750,00	100 %	883.572,91	-22.570,73	voll
SUSS MicroOptics S.A., Hauterive, Schweiz	CHF	500.000,00	100 %	8.929.168,39	502.912,00	voll
SUSS MicroTec, Inc., Corona, USA	USD	4.197.000,00	100 %	18.558.845,00	-1.245.367,05	voll
SUSS MicroTec (Taiwan) Company Ltd., Hsin Chu, Taiwan	TWD	5.000.000,00	100 %	191.696.514,00	42.857.281,00	voll
SUSS MicroTec Company Ltd., Shanghai, China	CNY	1.655.320,00	100 %	41.898.569,53	4.290.620,73	voll
HUGLE Lithography Inc., San Jose, USA ³	USD	1.190.442,00	53,1 %	-39.579,00	-2.580,00	at cost
SUSS MicroTec REMAN GmbH, Oberschleißheim ²	EUR	25.564,59	100 %	1.603.189,30	1.397.317,24	voll
SUSS MicroTec (Singapore) Pte Ltd., Singapur	SGD	25.000,00	100 %	3.702.968,47	1.436.380,48	voll
SUSS MicroTec Korea Co. Ltd., Hwaseong City, Korea	KRW	50.000.000,00	100 %	3.251.306.027,00	404.719.083,00	voll
SUSS MicroTec Photonic Systems Inc., Corona, USA	USD	10.400,00	100 %	-20.379.079,87	-9.955.389,55	voll

¹ Eigenkapital und Jahresergebnis vor Berücksichtigung der Ergebnisabführungsverträge mit der SUSS MicroTec Lithography GmbH und der SUSS MicroTec Reman GmbH und vor Berücksichtigung der Ergebniszurechnung von der SUSS MicroTec Photomask Equipment GmbH & Co. KG

² Eigenkapital und Jahresergebnis vor Berücksichtigung des Ergebnisabführungsvertrages mit der SÜSS MicroTec AG

³ wegen Unwesentlichkeit keine Konsolidierung

Für alle einbezogenen Unternehmen liegen Abschlüsse zum 31. Dezember des jeweiligen Jahres zugrunde.

Von den inländischen Tochtergesellschaften in der Rechtsform der Kapitalgesellschaft haben die SUSS MicroTec Lithography GmbH, Garching, und die SUSS MicroTec REMAN GmbH, Oberschleißheim, die gemäß § 264 Abs. 3 HGB erforderlichen Bedingungen für die Inanspruchnahme der Befreiungsvorschrift erfüllt. Auf eine Offenlegung der Jahresabschlussunterlagen wird daher verzichtet.

Die SUSS MicroTec Photomask Equipment GmbH & Co. KG (in der Rechtsform der Personengesellschaft) hat die gemäß § 264 b HGB erforderlichen Bedingungen für die Inanspruchnahme der Befreiungsvorschrift erfüllt. Auf eine Offenlegung der Jahresabschlussunterlagen wird daher verzichtet.

Erläuterungen zur IFRS-Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

Die folgenden Erläuterungen zur Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung beinhalten ausschließlich die fortgeführten Aktivitäten des Konzerns. Alle Angaben erfolgen – soweit nichts anderes angegeben ist – in Tsd. €.

(3) Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

in Tsd. €	2015	2014
Maschinen	111.660	107.913
Ersatzteile und Upgrades	18.349	23.779
Serviceleistungen	11.603	8.467
Mikrooptik	6.836	5.110
Sonstige	68	62
Umsatzerlöse	148.516	145.331

Hinsichtlich der Aufteilung der Umsatzerlöse auf Produktlinien und Regionen verweisen wir auf die Segmentberichterstattung.

(4) Umsatzkosten

In den Umsatzkosten sind insgesamt planmäßige Abschreibungen auf aktivierte Entwicklungsleistungen von 132 Tsd. € (Vorjahr: 456 Tsd. €) enthalten, die komplett auf das Segment Lithografie entfallen. Der zum 31. Dezember 2015 verbleibende Restbuchwert der aktivierten Entwicklungskosten in Höhe von 252 Tsd. € betrifft ebenfalls – wie auch im Vorjahr – ausschließlich das Segment Lithografie.

In den Umsatzkosten des aktuellen Geschäftsjahres sind darüber hinaus planmäßige Abschreibungen auf die erworbene Technologie der SUSS MicroTec Photonic Systems in Höhe von 288 Tsd. € (Vorjahr: 258 Tsd. €) enthalten. Diese Technologie weist zum 31. Dezember 2015 einen Restbuchwert von 1.225 Tsd. € auf.

Des Weiteren sind in die Umsatzkosten Wertminderungen auf Lagerbestände (Demogeräte, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie fertige und unfertige Erzeugnisse) von 5.056 Tsd. € (Vorjahr: 4.652 Tsd. €) eingeflossen. Dabei entfallen 3.533 Tsd. €

(Vorjahr: 2.978 Tsd. €) auf Bestände des Segments Lithografie und 1.364 Tsd. € (Vorjahr: 1.447 Tsd. €) auf Bestände des Segments Substrat Bonder. Die Bestände des Segments Fotomasken Equipment wurden um 158 Tsd. € (Vorjahr: 227 Tsd. €) abgewertet. Auf die Bestände des Segments Sonstiges entfallen im aktuellen Geschäftsjahr Abwertungen von 1 Tsd. € (Vorjahr: keine Abwertungen).

(5) Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

in Tsd. €	2015	2014
Fremdwährungsgewinne	2.962	1.265
Erträge aus einer Stornovereinbarung mit einem Kunden	607	0
Kommissionen	467	397
Reduzierung Earn-Out-Verpflichtung SUSS MicroTec Photonic Systems	0	293
Kfz-Sachbezüge	229	245
Aktivierte Eigenleistungen	107	217
Erträge aus der Lagerung von Maschinen für Kunden	0	198
Auflösung von sonstigen Verpflichtungen	182	241
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	51	1.280
Ablöse Mietereinbauten Sunnyvale (SMT Inc.)	67	0
Rückstellungsaufösungen	76	0
Teilweise Auflösung der bedingten Kaufpreisverpflichtung aus dem Erwerb der SMO	0	82
Erträge aus dem Abgang der 10%-Beteiligung an ElectronMec	0	40
Erstattungen von Versicherungen	0	35
Sonstige Zuschüsse	39	31
Mieterträge	32	25
Sonstiges	50	129
Sonstige betriebliche Erträge	4.869	4.478

Die Fremdwährungsgewinne entstanden im Wesentlichen aus verschiedenen Geschäftsvorfällen im operativen Bereich, die in Fremdwährung abgewickelt wurden (vorwiegend in US-Dollar und japanischen Yen) und durch die unterjährige Veränderung der Wechselkurse beeinflusst waren. Zudem sind hier Erträge aus der Stichtagsbewertung von konzerninternen Verrechnungskonten erfasst, die aus Sicht der bilanzierenden Gesellschaft in Fremdwährung bestehen.

Die Kommissionen wurden von unserer Tochtergesellschaft in China erzielt.

Die aktivierten Eigenleistungen betreffen Eigenleistungen im Zusammenhang mit der Erweiterung des konzernweiten SAP-Systems. 2015 wurde die SUSS MicroTec Photonic Systems Inc. (Corona, USA) an das SAP-System angebunden; die Umstellung auf das neue System erfolgte im zweiten Quartal 2015. Von Mitarbeitern der SÜSS MicroTec AG und der SUSS MicroTec Lithography GmbH wurden hierfür umfangreiche Eigenleistungen erbracht, die aktiviert wurden. Im Vorjahr betrafen die aktivierten Eigenleistungen ein SAP-Modul für Personalwirtschaft für die deutschen Gesellschaften, Leistungen für die geplante SAP-Einführung bei der SUSS MicroTec Photonic Systems Inc. (Corona, USA) sowie Leistungen für ein neues Customer Relationship Management-System.

Die Vorjahres-Erträge aus der Reduzierung der Earn-Out-Verpflichtung SUSS MicroTec Photonic Systems resultierten aus einer Komplett-Auflösung der noch verbliebenen Earn-Out-Verpflichtung, die im Rahmen der Erstkonsolidierung der Tamarack Scientific Co., Inc. passiviert wurde.

Die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen resultieren aus der SÜSS MicroTec AG.

Aus dem Verkauf der 10%-Beteiligung an der Electron Mec S.r.l. mit Sitz in Mailand, Italien erzielte die SUSS MicroTec Lithography GmbH im Vorjahr einen Veräußerungserlös in Höhe von 40 Tsd. €. Die Beteiligung gehörte seit 1996 zur SÜSS MicroTec-Gruppe.

Die sonstigen Zuschüsse in Höhe von rund 39 Tsd. € wurden von unserer Tochtergesellschaft in China erzielt. Auch die Zuschüsse des Vorjahres in Höhe von 31 Tsd. € betrafen Zuschüsse an SUSS MicroTec China.

(6) Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

in Tsd. €	2015	2014
Fremdwährungsverluste	3.157	2.021
Sonstige Steuern	576	546
Zuführung von Wertberichtigungen auf zweifelhafte Forderungen	368	44
Aufwendungen für eine Stornovereinbarung mit einem Kunden	135	0
Verluste aus Anlagenabgang	0	6
Sonstiges	138	78
Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.374	2.695

Die Fremdwährungsverluste entstanden – wie im Vorjahr – im Wesentlichen aus Bewertungsänderungen von Kundenforderungen in US-Dollar aufgrund unterjährig veränderter Wechselkurse sowie aus Bewertungsänderungen von konzerninternen Verrechnungskonten in Fremdwährung. Im Vorjahr resultierten 103 Tsd. € der Fremdwährungsverluste aus der Rückführung von konzerninternen Fremdwährungskrediten durch die SÜSS MicroTec AG gegenüber der SUSS MicroTec, Inc. (USA). Dieser Betrag wurde bis zur Rückführung der Kredite im Vorjahr im sonstigen Ergebnis (OCI) erfasst.

Die Zuführungen zu Wertberichtigungen auf zweifelhafte Forderungen wurden im Wesentlichen von der SUSS MicroTec Lithography GmbH und der SUSS MicroOptics, S.A. (Hauterive, Schweiz) gebildet.

(7) Finanzergebnis

Das Finanzergebnis setzt sich aus Zinsaufwendungen und Zinserträgen sowie sonstigen Finanzaufwendungen und sonstigen Finanzerträgen zusammen.

Die Finanzerträge in Höhe von 258 Tsd. € (Vorjahr: 349 Tsd. €) resultieren im Wesentlichen aus Zinserträgen für Geldmarktanlagen und Wertpapieren.

Die Finanzaufwendungen setzen sich folgendermaßen zusammen:

in Tsd. €	2015	2014
Bankverbindlichkeiten	383	428
Avalprovisionen	34	37
Buchverluste aus der Einlösung von Wertpapieren	71	28
Aufzinsung von Rückstellungen	0	29
Sonstige Zins- und Finanzaufwendungen	38	23
Finanzaufwendungen	526	545

Die Zinsen für Bankverbindlichkeiten haben sich im Vergleich zum Vorjahr verringert und betrafen im Wesentlichen die Zinsaufwendungen für die Grundstücksfinanzierungen Sternenfels (Darlehensstand zum 31. Dezember 2015: 3.600 Tsd. €) und Garching (Darlehensstand zum 31. Dezember 2015: 5.500 Tsd. €). Auf das Darlehen für die Grundstücksfinanzierung Sternenfels entfielen im Berichtsjahr 147 Tsd. € Zinsen (Vorjahr: 154 Tsd. €). Das Darlehen für die Grundstücksfinanzierung Garching verursachte im Berichtsjahr Zinsaufwendungen in Höhe von 224 Tsd. € (Vorjahr: 260 Tsd. €).

Die Buchverluste aus der Einlösung von Wertpapieren resultieren aus dem unterjährigen Erwerb von Unternehmensanleihen, deren Kaufpreis über dem Nominalwert lag. Die erworbenen Anleihen wiesen eine kurze Restlaufzeit auf und wurden vor dem 31. Dezember 2015 fällig. Die Einlösung bei Fälligkeit erfolgte zum Nominalwert.

(8) Ertragsteuern

Der Steueraufwand und die Aufteilung in laufende und latente Steuern stellen sich wie folgt dar:

in Tsd. €	2015	2014
Laufender Steueraufwand	2.975	1.570
Latenter Steuerertrag (-)/-aufwand	1.505	2.017
davon auf temporäre Differenzen	-420	1.067
Gesamtaufwand	4.480	3.587

Die folgende Tabelle zeigt eine Überleitungsrechnung vom im jeweiligen Geschäftsjahr erwarteten zum ausgewiesenen Steueraufwand.

in %	2015	2014
Angenommener Steuersatz		
Körperschaftsteuer	15,00	15,00
Solidaritätszuschlag	5,50	5,50
Gewerbesteuer	12,43	12,43
Kombinierter Steuersatz	28,25	28,25
in Tsd. €	2015	2014
Ergebnis vor Steuern	4.705	8.200
Erwartete Ertragsteuern	1.329	2.317
Abweichende Steuersätze im Ausland	-1.505	-875
Mindestbesteuerung	0	94
Gewerbsteuerliche Hinzurechnungen und Kürzungen	8	13
Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	198	181
Steueraufwand Vorjahre	219	111
Veränderung der Wertberichtigung auf aktive latente Steuern	4.382	2.499
Inanspruchnahme wertberechtigter Verlustvorträge	0	-435
Steuerfreie Erträge	-27	-292
Steuerliche Zuschüsse	-71	0
Sonstiges	-53	-26
Effektive Ertragsteuern	4.480	3.587

Die Gegenüberstellung der erwarteten zu den effektiven Ertragsteuern aus den fortgeführten Aktivitäten zeigt eine Abweichung von -3.151 Tsd. € (Vorjahr: -1.270 Tsd. €). Anstatt eines erwarteten Steueraufwands in Höhe von 1.329 Tsd. € ergab sich auf Konzernebene im Berichtsjahr ein Steueraufwand in Höhe von 4.480 Tsd. €.

Im Berichtsjahr wurden zusätzliche Wertberichtigungen auf aktive latente Steuern in Höhe von 4.382 Tsd. € gebildet. Der größte Wertberichtigungsbedarf entstand bei den US-Gesellschaften SUSS MicroTec, Inc., Corona (Kalifornien, USA), und SUSS MicroTec Photonic Systems Inc., Corona (Kalifornien, USA). Die beiden US-Gesellschaften SUSS MicroTec, Inc. und SUSS MicroTec Photonic Systems Inc. bilden eine „Tax Group“, deren zu versteuerndes Einkommen in den USA der Gruppenbesteuerung unterliegt. Auf Basis der aktuellen Konzernplanung wird für die SUSS MicroTec Photonic Systems in den nächsten drei Jahren ein negatives Ergebnis erwartet. Das Ergebnis der SUSS MicroTec, Inc. wird ab dem kommenden Jahr voraussichtlich leicht positiv sein.

Der Steueraufwand für Vorjahre betrifft im Wesentlichen voraussichtliche Steuernachzahlungen der SÜSS MicroTec AG, die sich aus der laufenden Betriebsprüfung ergeben haben.

Der tatsächliche Steueraufwand für Vorjahre beläuft sich auf 534 Tsd. €

Der positive Steuereffekt aus der Erzielung von steuerfreien Erträgen war im Vorjahr im Wesentlichen auf die Erträge aus der Auflösung der noch verbliebenen Earn-Out-Verpflichtung zurückzuführen, die im Zuge der Neu beurteilung zum Jahresende erfasst wurden.

Es wurde keine Steuerabgrenzung auf nicht ausgeschüttete Gewinne von Tochtergesellschaften vorgenommen. Von einer Ermittlung der möglichen steuerlichen Auswirkungen wurde wegen des unverhältnismäßig hohen Aufwands abgesehen.

Die Abgrenzungsposten für latente Steuern ermitteln sich wie folgt:

in Tsd. €	Aktiva		Passiva	
	2015	2014	2015	2014
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	89	57	0	0
Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.160	1.127	0	0
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0	4	2	20
Langfristige Rückstellungen	0	11	3	3
Immaterielle Vermögenswerte	1.503	2.184	0	0
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	101	64	1	0
Geschäfts- oder Firmenwert	0	0	2.064	2.064
Passiver Ausgleichsposten SMT Photomask Equipment	0	0	303	336
Vorräte	1.450	495	0	0
Sachanlagen	12	0	0	1
Sonstiges	117	134	16	96
Verlustvorräte	410	2.334	0	0
Saldierung	-2.389	-2.520	-2.389	-2.520
Gesamt	2.453	3.890	0	0

Der Konzern verfügt über steuerliche Verlustvorräte in Höhe von 54.554 Tsd. € (Vorjahr: 46.646 Tsd. €). Davon verfallen im Zeitraum bis zum 31. Dezember 2024 insgesamt 5.785 Tsd. €. Im Zeitraum von 2028 bis 2035 verfallen insgesamt 46.360 Tsd. €. Verlustvorräte in Höhe von 2.409 Tsd. € sind unbegrenzt nutzbar.

Der Anstieg der Verlustvorräte im Vergleich zum Vorjahr resultiert im Wesentlichen aus dem negativen Jahresergebnis der US-amerikanischen Tax Group der SÜSS MicroTec, Inc. und der SÜSS MicroTec Photonic Systems Inc. Zum 31. Dezember 2015 verfügt diese Tax Group in den USA über Verlustvorräte in Höhe von 50.497 Tsd. USD. Die Verlustvorräte in Deutschland haben sich hingegen durch das positive Ergebnis der Organgesellschaften SÜSS MicroTec Lithography GmbH und SÜSS MicroTec REMAN GmbH sowie durch das ebenfalls positive Ergebnis der SÜSS MicroTec Photomask Equipment GmbH & Co. KG auf 1.452 Tsd. € (Vorjahr: 8.263 Tsd. €) reduziert.

Für Verlustvorräte in Höhe von 53.102 Tsd. € (Vorjahr: 38.383 Tsd. €) und temporäre Differenzen in Höhe von 12.699 Tsd. € (Vorjahr: 10.031 Tsd. €) wurden keine aktiven latenten Steuern angesetzt.

Nach IAS 12.74f. ist eine Saldierung aktiver und passiver latenter Steuern vorzunehmen, wenn zum einen eine zivilrechtliche Aufrechnungslage gegeben ist, und zum anderen die latenten Steueransprüche und latenten Steuerschulden sich auf Ertragsteuern beziehen, die von der gleichen Steuerbehörde erhoben werden. Zum 31. Dezember 2015 wurden somit aktive und passive latente Steuern in Höhe von 2.389 Tsd. € (Vorjahr: 2.520 Tsd. €) saldiert.

(9) Ergebnis je Aktie

Die folgende Tabelle zeigt die Ermittlung des unverwässerten und verwässerten Ergebnisses je Aktie.

in Tsd. €	2015	2014
Gewinn, der auf Aktionäre der SÜSS MicroTec AG entfällt	225	4.613
Gewichteter Durchschnitt ausstehender Aktien (Stück)	19.115.538	19.115.538
Effekt aus der (potenziellen) Ausübung von Aktienoptionen (Stück)	0	0
Angepasste gewichtete durchschnittliche Anzahl ausstehender Aktien (Stück)	19.115.538	19.115.538
Ergebnis je Aktie in EUR – unverwässert –	0,01	0,24
Ergebnis je Aktie in EUR – verwässert –	0,01	0,24

(10) Sonstige Angaben zur IFRS-Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

AUFWENDUNGEN FÜR FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG

Neben den in der Gewinn- und Verlustrechnung explizit ausgewiesenen Aufwendungen für Forschung und Entwicklung sind im Geschäftsjahr auch Abschreibungen auf aktivierte Entwicklungskosten erfasst worden sowie in geringem Umfang Neu-Aktivierungen von Entwicklungskosten vorgenommen worden.

Die Netto-Investitionen und Aufwendungen für Forschung und Entwicklung stellen sich wie folgt dar:

in Tsd. €	2015	2014
Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen	12.787	10.490
Abschreibungen auf aktivierte Entwicklungskosten	132	456
Neu-Aktivierungen von Entwicklungskosten	1	45
Netto-Investitionen	-131	-411

PERSONALAUFWAND

In der Gewinn- und Verlustrechnung der SÜSS MicroTec-Gruppe sind im Folgenden dargestellte Personalaufwendungen in den verschiedenen Positionen enthalten:

in Tsd. €	2015	2014
Löhne und Gehälter	48.462	43.016
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	5.804	4.106
Aufwendungen für Altersvorsorge	2.972	2.749
Personalaufwand	57.238	49.871

Die sozialen Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung enthalten vor allem die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Berufsgenossenschaftsbeiträge.

Die Aufwendungen für Altersvorsorge beinhalten Pensionsaufwendungen aus betrieblichen Versorgungsplänen sowie Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Rentenversicherung.

MATERIALAUFWAND

Die Materialaufwendungen betragen im Geschäftsjahr 2015 48.534 Tsd. € (Vorjahr: 54.851 Tsd. €).

ABSCHREIBUNGEN

Die Abschreibungen setzen sich wie folgt zusammen:

in Tsd. €	2015	2014
Immaterielle Vermögenswerte	1.239	1.515
Sachanlagen	2.944	2.734
Abschreibungen	4.183	4.249

Im Geschäftsjahr wurden Konzessionen und gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten in Höhe von 819 Tsd. € (Vorjahr: 801 Tsd. €) und aktivierte Entwicklungskosten in Höhe von 132 Tsd. € (Vorjahr: 456 Tsd. €) abgeschrieben.

Die im Rahmen der Erstkonsolidierung der SÜSS MicroTec Photonic Systems angesetzte Technologie und weitere erworbene immaterielle Vermögenswerte wurden mit 288 Tsd. € (Vorjahr: 258 Tsd. €) abgeschrieben.

Erläuterungen zu den Aktiva

Die folgenden Erläuterungen zur Konzernbilanz beinhalten für das Berichtsjahr ausschließlich die fortgeführten Aktivitäten des Konzerns. Alle Angaben erfolgen – soweit nichts anderes angegeben ist – in Tsd. €.

(11) Immaterielle Vermögenswerte

Unter den immateriellen Vermögenswerten werden zum Stichtag neben Patenten, Lizenzen und ähnlichen Rechten in Höhe von 2.789 Tsd. € (Vorjahr: 2.732 Tsd. €) Entwicklungsleistungen von 252 Tsd. € (Vorjahr: 382 Tsd. €) und die erworbene Technologie der SUSS MicroTec Photonic Systems von 1.225 Tsd. € (Vorjahr: 1.357 Tsd. €) ausgewiesen. Die Technologie wird planmäßig über acht Jahre abgeschrieben und weist eine verbleibende Restnutzungsdauer bis zum 31. März 2020 auf. In den Patenten, Lizenzen und ähnlichen Rechten ist das konzernweite SAP-System enthalten.

Die aktivierten Entwicklungsleistungen stehen im Wesentlichen im Zusammenhang mit der Entwicklung neuer Maschinen. Der Restbuchwert zum 31. Dezember 2015 betrifft allein das Segment Lithografie.

Unter den anderen immateriellen Vermögenswerten wird die im Rahmen der Unternehmensakquisition der SUSS MicroTec Photonic Systems erworbene Technologie mit einem Restbuchwert von 1.225 Tsd. € (Vorjahr: 1.357 Tsd. €) ausgewiesen. Da der Wert der Technologie in US-Dollar erfasst und fortgeführt wurde, wirkt die Veränderung des Umrechnungskurses des US-Dollar im Vergleich zum Euro zum 31. Dezember 2015 werterhöhend.

(12) Geschäfts- oder Firmenwert

Der zum Bilanzstichtag ausgewiesene Geschäfts- oder Firmenwert in Höhe von 15.772 Tsd. € (Vorjahr: 15.546 Tsd. €) entfällt in voller Höhe auf die Cash Generating Unit Lithografie.

(13) Sachanlagen

Die Aufgliederung der in der Bilanz zusammengefassten Positionen des Sachanlagevermögens sowie ihre Entwicklung im Berichtsjahr sind im Anlagespiegel, der Bestandteil dieses Anhangs ist, enthalten.

(14) Sonstige (langfristige) Vermögenswerte

Die sonstigen langfristigen Vermögenswerte enthalten Aktivwerte von Rückdeckungsversicherungen, welche die Verrechnungskriterien mit bestehenden Pensionsrückstellungen nicht erfüllen, sowie geleistete Kautionen für angemietete Bürogebäude.

in Tsd. €	2015	2014
Rückdeckungsversicherung	156	150
Kautionen	455	413
Sonstige langfristige Vermögenswerte	611	563

(15) Vorräte

Die Vorräte lassen sich wie folgt aufteilen:

in Tsd. €	2015	2014
Materialien und Hilfsstoffe	28.610	22.091
Unfertige Erzeugnisse	27.237	26.109
Fertigerzeugnisse	11.180	8.971
Demonstrationsgeräte	20.032	20.490
Handelswaren	869	838
Wertberichtigungen	-19.209	-19.616
Vorratsvermögen	68.719	58.883

Von dem Gesamtbetrag der zum 31. Dezember 2015 bilanzierten Vorräte in Höhe von 68.719 Tsd. € (Vorjahr: 58.883 Tsd. €) sind 29.579 Tsd. € (Vorjahr: 29.547 Tsd. €) zu ihrem Nettoveräußerungswert bilanziert.

Der Betrag der Vorräte, der im Geschäftsjahr als Aufwand erfasst wurde, beträgt rund 85.244 Tsd. € (Vorjahr: 85.580 Tsd. €).

(16) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen teilen sich wie folgt auf:

in Tsd. €	2015	2014
Forderungen gegen Dritte	13.564	13.713
Wertberichtigungen	-471	-323
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.093	13.390

Die folgende Tabelle gibt die Veränderungen in den Wertberichtigungen auf den Bestand der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wieder.

in Tsd. €	2015	2014
Wertberichtigungen zum Beginn des Geschäftsjahres	323	1.815
Ausbuchung von Forderungen	-169	-256
Zahlungseingänge und Wertaufholungen auf ursprünglich abgeschriebene Forderungen	-51	-1.280
Zuführung	368	44
Wertberichtigungen zum Geschäftsjahresende	471	323

(17) Sonstige finanzielle Vermögenswerte

Unter den sonstigen finanziellen Vermögenswerten sind folgende Positionen ausgewiesen:

in Tsd. €	2015	2014
Zinsabgrenzungen	6	29
Förderprojekte	0	31
Lieferantenboni	118	57
Bietungsgarantien	38	41
Mitarbeiterforderungen	24	24
Sonstiges	35	22
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	221	204

Die Zinsabgrenzungen betreffen Zinsansprüche für Festgelder.

(18) Wertpapiere

Die SÜSS MicroTec AG hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Teil ihrer Liquidität in zur Veräußerung verfügbare Wertpapiere investiert. Dabei handelte es sich im Wesentlichen um verzinsliche Unternehmens- und Staatsanleihen sowie Commercial Papers. Die Bewertung der Wertpapiere erfolgt zu Marktpreisen. Etwaige Marktpreisschwankungen werden erfolgsneutral im kumulierten übrigen Eigenkapital abgebildet.

Zum 31. Dezember 2015 waren keine Wertpapiere im Bestand der Gesellschaft (Vorjahr: 1.026 Tsd. €).

(19) Steuererstattungsansprüche

Die langfristigen Steuerforderungen resultieren aus der Aktivierung des Körperschaftsteuer-Guthabens deutscher Konzerngesellschaften in Höhe von 34 Tsd. € (Vorjahr: 50 Tsd. €) in Folge des Gesetzes über steuerliche Begleitmaßnahmen zur Einführung der Europäischen Gesellschaft und zur Änderung weiterer steuerrechtlicher Vorschriften (SEStEG). Das Guthaben wird in zehn gleichen Jahresbeträgen in den Jahren 2008 bis 2017 ausbezahlt. Da der Auszahlungsbetrag unverzinslich ist, erfolgte eine entsprechende Abzinsung. Weitere 3 Tsd. € betreffen Rückerstattungsansprüche der SÜSS MicroTec Ltd. (Market Rasen, Großbritannien).

Die kurzfristigen Steuerforderungen setzen sich wie folgt zusammen:

in Tsd. €	2015	2014
Geleistete Steuervorauszahlungen	264	691
Steuerliche Zuschüsse	150	34
Steuererstattungsansprüche	414	725

(20) Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

Bei den Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten in Höhe von 49.085 Tsd. € (Vorjahr: 47.309 Tsd. €) handelt es sich um Kassenbestände, Schecks sowie Guthaben bei Kreditinstituten, die innerhalb von drei Monaten vom Zeitpunkt der Einlage verfügbar sind. Die Veränderung zum Vorjahr wird in der Konzernkapitalflussrechnung dargestellt.

(21) Sonstige (kurzfristige) Vermögenswerte

Unter den sonstigen kurzfristigen Vermögenswerten sind folgende Positionen enthalten:

in Tsd. €	2015	2014
Aktive Rechnungsabgrenzung	822	1.061
Geleistete Anzahlungen	400	172
Umsatzsteuer	804	312
Kautionen	0	59
Bietungsgarantien	100	71
Scheckforderungen	44	0
Sonstiges	102	34
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	2.272	1.709

Die aktive Rechnungsabgrenzung enthält Vorauszahlungen für zukünftige Aufwendungen, z. B. Versicherungsbeiträge oder Mietvorauszahlungen.

Erläuterungen zu den Passiva

(22) Eigenkapital

GEZEICHNETES KAPITAL

Das Grundkapital der SÜSS MicroTec AG betrug zum Bilanzstichtag unverändert 19.115.538,00 € (eingeteilt in 19.115.538 auf den Namen lautende und voll einbezahlte Stückaktien mit einem rechnerischen Nennwert von je 1,00 €). Wir verweisen hier auf die Darstellung der Eigenkapital-Veränderungsrechnung.

Jede Stückaktie berechtigt zur Abgabe einer Stimme bei Abstimmungen. Die Stückaktien sind nicht rückzahlbar und nicht konvertierbar. Dividenden können ausschließlich aus den ausschüttbaren Gewinnen gemäß handelsrechtlichem Jahresabschluss der SÜSS MicroTec AG ausgeschüttet werden.

Das genehmigte Kapital beträgt zum Bilanzstichtag 9.000 Tsd. € (Vorjahr: 9.000 Tsd. €).

in Tsd. €	2015	2014
Grundkapital	19.116	19.116
Genehmigtes Kapital	9.000	9.000
Bedingtes Kapital	0	0

RÜCKLAGEN

Die Rücklagen des Konzerns setzen sich wie folgt zusammen:

in Tsd. €	2015	2014
Kapitalrücklage	97.614	97.614
Gewinnrücklage	433	433
Bilanzgewinn	762	537
Rücklagen	98.809	98.584

Die Kapitalrücklage ist im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

Die Gewinnrücklage ist im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

Aufgrund des positiven Jahresergebnisses in Höhe von 225 Tsd. € ergibt sich zum 31. Dezember 2015 ein Bilanzgewinn in Höhe von 762 Tsd. €.

KUMULIERTES ÜBRIGES EIGENKAPITAL

Die Entwicklung des kumulierten übrigen Eigenkapitals stellt sich wie folgt dar:

in Tsd. €	2015	2014
Neubewertung von leistungsorientierten Plänen	-2.313	-1.331
Fremdwährungsanpassungen	492	-2.426
Absicherung künftiger Zahlungsströme	-486	-342
Unrealisierte Gewinne/Verluste aus Wertpapieren	11	30
Steuereffekte		
Neubewertung von leistungsorientierten Plänen	532	333
Unrealisierte Gewinne/Verluste aus Wertpapieren	13	0
Absicherung künftiger Zahlungsströme	121	81
Stand zu Beginn der Periode	-1.630	-3.655
Veränderungen vor Steuern		
Neubewertung von leistungsorientierten Plänen	-532	-982
Fremdwährungsanpassungen	2.765	2.918
Absicherung künftiger Zahlungsströme	76	-144
Unrealisierte Gewinne/Verluste aus Wertpapieren	-11	-19
Steuereffekte		
Neubewertung von leistungsorientierten Plänen	165	199
Unrealisierte Gewinne/Verluste aus Wertpapieren	3	13
Absicherung künftiger Zahlungsströme	-21	40
Stand am Ende der Periode	815	-1.630

Die SÜSS MicroTec AG hat 2010 einen Zinsswap als Sicherungsinstrument für das variabel verzinsliche Darlehen, das der Finanzierung des neu erworbenen Grundstücks in Sternenfels dient, abgeschlossen. Für diesen Zinsswap wurde Hedge Accounting angewendet: Anstelle der Abbildung in der Gewinn- und Verlustrechnung werden die Marktwertänderungen im kumulierten übrigen Eigenkapital abgebildet.

EIGENKAPITALMANAGEMENT

Das Eigenkapital des SÜSS MicroTec-Konzerns – bestehend aus dem gezeichneten Kapital, den Rücklagen und dem kumulierten übrigen Eigenkapital – beläuft sich zum 31. Dezember 2015 auf insgesamt 118.740 Tsd. € (Vorjahr: 116.070 Tsd. €); das

entspricht einer Eigenkapitalquote von 67,0 % (Vorjahr: 69,1 %). Neben einer angemessenen Eigenkapitalrentabilität strebt der SÜSS MicroTec-Konzern eine nachhaltig hohe Eigenkapitalquote sowie eine hohe Liquiditätsreserve an, um künftiges Wachstum sicherzustellen und den Unternehmenswert zu steigern. Zur Aufrechterhaltung oder Anpassung der Kapitalstruktur kann der Konzern alle Möglichkeiten nutzen, die die Börsennotierung der SÜSS MicroTec AG mit sich bringt.

Der Vorstand der Gesellschaft geht nach derzeitigem Planungsstand davon aus, im kommenden Geschäftsjahr ein positives Ergebnis zu erzielen. Bei einer Verfehlung der Planung besteht die Gefahr, dass sich das Eigenkapital in Folge eines Jahresfehlbetrags verringern könnte.

(23) Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Das Unternehmen gewährt verschiedene Versorgungszusagen, die im Wesentlichen die Risiken Alter, Tod und Invalidität berücksichtigen. Die Pläne unterscheiden sich je nach rechtlichen, steuerlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der einzelnen Länder. Die Leistungen berechnen sich in der Regel auf Basis der Gehälter und der Dauer der Betriebszugehörigkeit der versicherten Mitarbeiter.

Es ist zwischen leistungs- und beitragsorientierten Versorgungssystemen zu unterscheiden. Bei leistungsorientierten Versorgungszusagen besteht die Verpflichtung des Konzerns darin, die zugesagten Leistungen an ehemalige Mitarbeiter zu erfüllen, für die entsprechende Rückstellungen gebildet werden.

Bei beitragsorientierten Versorgungsplänen geht der Konzern über die Entrichtung von Beitragszahlungen an zweckgebundene Fonds hinaus keine weitere Verpflichtung ein. Die Beitragszahlungen werden ergebniswirksam erfasst, Rückstellungen werden hier nicht gebildet.

Die Pensionsverpflichtungen setzen sich wie folgt zusammen:

in Tsd. €	2015	2014
Barwert der Pensionsverpflichtungen	9.003	7.278
Zeitwert des Planvermögens	-3.859	-2.527
Errechnete Pensionsverbindlichkeiten	5.144	4.751

LEISTUNGSORIENTIERTE PLÄNE („DEFINED BENEFIT PLANS“)

Der Konzern verfügt in Deutschland, Japan und in der Schweiz über leistungsorientierte Pensionspläne.

Die vorhandenen Pensionszusagen in Deutschland umfassen Ansprüche auf Alters-, Invaliden- und Hinterbliebenenrenten, ausgestaltet einerseits in Abhängigkeit vom Jahresgehalt und andererseits als feste Zusagen. Anspruchsberechtigt sind ausgewählte Personen der Geschäftsleitung. Die wesentlichen versicherungsmathematischen Annahmen sind nachfolgend dargestellt:

in %	2015	2014
Abzinsungssatz	1,91	1,93
Erwartete Rendite auf das Planvermögen	1,91	1,93
Gehaltssteigerung	0,00	0,00
Rentensteigerung	2,00	2,00

Lebenserwartung gem. Richttafeln Dr. Heubeck 2005 G

Beim Gehalt wurden keine Steigerungsraten berücksichtigt, da in den deutschen Plänen keine aktiven Anwärter mehr enthalten sind.

Die Pensionszusagen der Tochtergesellschaft in der Schweiz umfassen Ansprüche auf Alters-, Invaliden- und Hinterbliebenenrenten, ausgestaltet in Abhängigkeit vom Grundgehalt. Anspruchsberechtigt sind alle Angestellten und Geschäftsführer der Tochtergesellschaft.

Die wesentlichen versicherungsmathematischen Annahmen sind nachfolgend dargestellt:

in %	2015	2014
Abzinsungssatz	0,90	1,10
Erwartete Rendite auf das Planvermögen	0,90	1,10
Gehaltssteigerung	1,50	1,50
Rentensteigerung	0,00	0,00

Die Tochtergesellschaft in Japan verfügt über einen beitragsfreien und ungedeckten leistungsorientierten Pensionsplan, aus dem bestimmte Mitarbeiter nach Ausscheiden aus dem Unternehmen eine Pensionszahlung erhalten. Die Höhe der Pensionszahlung richtet sich nach einem festgelegten Berechnungsschema und sieht für jeden anspruchsberechtigten Mitarbeiter eine Zuwendung von 80 % eines Monatsgehalts pro Beschäftigungsjahr vor. Anspruchsberechtigt ist jeder Mitarbeiter der Gesellschaft nach einer Betriebszugehörigkeit von mindestens drei Jahren.

Die wesentlichen versicherungsmathematischen Annahmen sind nachfolgend dargestellt:

in %	2015	2014
Abzinsungssatz	0,42	1,00
Gehaltssteigerung	1,67	1,63
Rentensteigerung	0,00	0,00

Die Anwartschaftsbarwerte der Versorgungsverpflichtungen und beizulegenden Zeitwerte des Planvermögens haben sich in den Geschäftsjahren 2015 und 2014 wie folgt entwickelt:

in Tsd. €	2015	2014
Anwartschaftsbarwert am 01.01.	7.278	5.935
Dienstzeitaufwand	337	351
Zinsaufwand	109	156
Pensionszahlungen	482	-206
Versicherungsmathematischer (-) Gewinn/ (+) Verlust aus Veränderungen der finanziellen Annahmen	186	879
Versicherungsmathematischer (-) Gewinn/ (+) Verlust aus Veränderungen der demografischen Annahmen	0	-55
Versicherungsmathematischer (-) Gewinn/ (+) Verlust aus erfahrungsbedingten Anpassungen	174	176
Währungsveränderungen	437	42
Anwartschaftsbarwert am 31.12.	9.003	7.278

in Tsd. €	2015	2014
Planvermögen am 01.01.	2.527	2.175
Erwartete Erträge aus dem Planvermögen	36	56
Geleistete Fondsdotierungen	1.052	253
Versicherungsmathematischer (+) Gewinn/ (-) Verlust	53	15
Währungsveränderungen	191	28
Planvermögen am 31.12.	3.859	2.527

Die wesentlichen Komponenten des Planvermögens sind Rückdeckungsversicherungen. Im Zusammenhang mit den Pensionsverpflichtungen in Deutschland wurden entsprechende Rückdeckungsversicherungen bei der Allianz Lebensversicherungs-AG abgeschlossen. Die Pensionsverpflichtungen in der Schweiz sind über die Helvetia Sammelstiftung abgesichert, die hierfür entsprechende Rückdeckungsversicherungen abgeschlossen hat. Die beiden Rückdeckungsversicherungen sind als konservative, risikoarme Anlageform zu sehen, deren Wert nur geringen Marktschwankungen unterliegt.

Der Barwert der Pensionsverpflichtungen entfällt in Höhe von 6.778 Tsd. € (Vorjahr: 4.987 Tsd. €) auf fondsfinanzierte Versorgungsansprüche.

Die Pensionsaufwendungen gliedern sich wie folgt:

in Tsd. €	2015	2014
Dienstzeitaufwand	202	227
Personalaufwandskomponente	202	227
Zinsaufwand	88	125
Erwartete Erträge aus dem Planvermögen	-15	-25
Versicherungsmathematische Gewinne/Verluste	19	85
Zinsaufwandskomponente	92	185

Für 2016 erwartet der Konzern zur Erfüllung der Pensionsverpflichtungen Zahlungsmittelabflüsse von insgesamt 338 Tsd. €.

In der folgenden Übersicht wird aufgezeigt, in welcher Weise der Barwert aller definierten Leistungsverpflichtungen durch Veränderungen der maßgeblichen versicherungsmathematischen Annahmen beeinflusst worden wäre:

in Tsd. €	2015
Barwert aller definierten Leistungsverpflichtungen, falls	
der Abzinsungssatz 50 Basispunkte niedriger wäre	9.692
der Abzinsungssatz 50 Basispunkte höher wäre	8.404
die Lohnsteigerung 50 Basispunkte niedriger wäre	8.893
die Lohnsteigerung 50 Basispunkte höher wäre	9.117
die künftige Rentensteigerung 0,50 % niedriger wäre	8.624
die künftige Rentensteigerung 0,50 % höher wäre	9.413

BEITRAGSORIENTIERTE PLÄNE („DEFINED CONTRIBUTION PLANS“)

Der Konzern hat für seine Mitarbeiter in den USA einen „Defined Contribution Plan“ eingerichtet. Von dem Plan profitieren alle Mitarbeiter der SUSS MicroTec Photonic Systems Inc. (Corona) und der SUSS MicroTec, Inc. (Corona) ab einem Alter von 18 bzw. 21 Jahren und einem Minimum an geleisteten Arbeitsstunden von 1.000 Stunden pro Jahr. Beide Defined Contribution Plans beinhalten zwei Komponenten: eine Gewinnbeteiligung und einen 401 (k) Plan.

Bei der SUSS MicroTec, Inc. werden die in den Gewinnbeteiligungsplan einfließenden Beiträge jährlich neu bestimmt. Sämtliche Beiträge des Unternehmens werden in einem „Trust Fund“ gehalten. Die anspruchsberechtigten Mitarbeiter erreichen den unverfallbaren Leistungsanspruch über einen Zeitraum von sechs Jahren.

Unter dem 401 (k) Plan beträgt der Arbeitgeberbeitrag 0,50 USD für jeden 1,00 USD des Arbeitnehmerbeitrages bis zu einem maximalen Arbeitnehmerbeitrag von 3.000 USD (d. h. der maximale Arbeitgeberbeitrag beträgt 1.500 USD). Anspruch auf den vollen Arbeitgeberbeitrag haben die Arbeitnehmer erst nach Vollendung des dritten Arbeitsjahres. Davor haben sie keinen Anspruch auf Arbeitgeberbeiträge.

Der 401 (k) Plan der SUSS MicroTec Photonic Systems Inc. bietet den Mitarbeitern die Möglichkeit, 25 % ihrer jährlichen Vergütung in den 401 (k) Plan einzubezahlen. Für jeden 1,00 USD Arbeitnehmerbeitrag wird ein Arbeitgeberbeitrag von 1,00 USD beigesteuert bis zu einem Maximalbetrag von 3 % des Gehalts. Die anspruchsberechtigten Mitarbeiter erreichen einen unverfallbaren Leistungsanspruch gestaffelt in 20 %-Schritten über einen Zeitraum von sechs Jahren.

Im Geschäftsjahr 2015 betragen die Aufwendungen des Konzerns für den 401 (k) Plan 131 Tsd. USD (Vorjahr: 185 Tsd. USD).

Weiterhin wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Rentenversicherung in Höhe von 2.841 Tsd. € (Vorjahr: 2.611 Tsd. €) abgeführt.

(24) (Langfristige) Rückstellungen

Die langfristigen Rückstellungen beinhalten Verpflichtungen des Konzerns aus Altersteilzeitvereinbarungen. Die Rückstellungen haben sich folgendermaßen entwickelt:

in Tsd. €	Stand 01.01.15	Verbrauch	Zuführung	Stand 31.12.15
Altersteilzeit	29	-18	0	11

Die im Rahmen einer Betriebsvereinbarung geschlossene Alterszeitregelung gilt für Arbeitnehmer der SUSS MicroTec Lithography GmbH und der SÜSS MicroTec AG, die das 57. Lebensjahr vollendet haben und im aktuellen Arbeitsverhältnis in den letzten fünf Jahren vor Beginn der Altersteilzeit mindestens drei Jahre eine Vollzeitbeschäftigung/Teilzeitbeschäftigung ausgeübt haben.

Während der Dauer der Altersteilzeit wird die bisherige Regelarbeitszeit auf 50 % reduziert. Die während der Altersteilzeit-Gesamtdauer zu erbringende Arbeitszeit wird regelmäßig so verteilt, dass diese vollständig in der ersten Hälfte der Altersteilzeit geleistet wird (Arbeitsphase) und der Mitarbeiter in der zweiten Hälfte von der Arbeitsleistung freigestellt wird (Freistellungsphase).

Zusätzlich zum auf 50 % reduzierten Bruttoarbeitsentgelt erhält der Mitarbeiter einen Aufstockungsbetrag, der so zu bemessen ist, dass das monatliche Altersteilzeit-Nettoentgelt mindestens 82 % des monatlichen Vollzeit-Nettoarbeitsentgelts beträgt. Der Aufstockungsbetrag wird steuer- und sozialversicherungsfrei gezahlt.

(25) Finanzschulden

Die Fälligkeitsstruktur der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie der Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing ergibt sich zum 31. Dezember 2015 bzw. zum Vorjahresstichtag wie folgt:

31.12.2015 in Tsd. €	Restlaufzeit bis zu einem Jahr	Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	Summe
Darlehensverbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.180	7.420	500	9.100
Kontokorrentverbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6	0	0	6
Gesamt	1.186	7.420	500	9.106

31.12.2014 in Tsd. €	Restlaufzeit bis zu einem Jahr	Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	Summe
Darlehensverbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.180	4.720	4.380	10.280
Verbindlichkeiten aus Finance Lease	7	0	0	7
Gesamt	1.187	4.720	4.380	10.287

VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER KREDITINSTITUTEN

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten enthalten Verbindlichkeiten aus einem langfristigen Darlehensvertrag in Höhe von 3.600 Tsd. € (Vorjahr: 3.780 Tsd. €), der der Finanzierung des Betriebsgrundstücks Sternenfels dient. Der Darlehensvertrag wurde am 25./28. Mai 2010 zwischen der SÜSS MicroTec AG und einer lokalen Bank abgeschlossen. Das Darlehen belief sich auf 4,5 Mio. € und hat eine Laufzeit bis zum 30. Juni 2020. Es wurde am 6. Juli 2010 valuiert und zur Auszahlung gebracht.

Darüber hinaus sind Verbindlichkeiten in Höhe von 5.500 Tsd. € (Vorjahr: 6.500 Tsd. €) enthalten, die der Finanzierung des 2013 erworbenen Betriebsgrundstücks Garching dienen. Der Darlehensvertrag wurde am 23./28. Oktober 2013 zwischen der SÜSS MicroTec AG und einer lokalen Bank abgeschlossen. Das Darlehen hat eine Laufzeit bis zum 30. Juni 2021. Es wurde am 16. Dezember 2013 valuiert und zur Auszahlung gebracht.

Im Einzelnen setzen sich die Darlehensstände per Ende des Geschäftsjahres wie folgt zusammen:

Konzerngesellschaft in Tsd. €	2015	2014	Zinssatz	Fälligkeit
SÜSS MicroTec AG	3.600	3.780	3,98 %	30.6.2020
SÜSS MicroTec AG	5.500	6.500	3,65 %	30.6.2021
Gesamt	9.100	10.280		
davon kurzfristig fällig	1.180	1.180		
davon langfristig fällig	7.920	9.100		
fällig 2016	1.180			
2017	1.180			
2018	1.180			
2019	1.180			
2020	3.880			
2021	500			
	9.100			

Die Gesellschaft verfügt über diverse Kreditlinien bei nationalen und internationalen Bankinstituten und Versicherungen. Die gesamten Kreditlinien und deren Inanspruchnahme haben sich wie folgt entwickelt:

in Tsd. €	2015	2014
Kredit- / Avallinie	9.000	8.000
Inanspruchnahme in Form von Avalen	5.443	3.484
Verfügbare Kredit- / Avallinie	3.557	4.516

Ein Bankenkonsortium unter Führung der Deutsche Bank AG und unter Beteiligung der DZ Bank AG und der Baden-Württembergischen Bank stellt Kredit- und Avallinien in Höhe von 4,5 Mio. €. Diese Linien wurden bis auf weiteres gewährt und wurden ohne Covenants gestellt. Die Deutsche Bank AG gewährt darüber hinaus eine bis zum 30. April 2016 befristete Avallinie in Höhe von 1,0 Mio. €. Die Linien können von der SÜSS MicroTec AG oder der SÜSS MicroTec Lithography GmbH in Anspruch genommen werden.

Die BW-Bank Mannheim gewährt der SÜSS MicroTec Photomask Equipment GmbH & Co. KG eine Kredit- und Avallinie in Höhe von 1,0 Mio. €. Die Kreditlinie läuft auf unbestimmte Zeit und wurde ohne Covenants gestellt.

Bei einer Versicherung besteht eine weitere Kreditlinie zur Unterlegung von Anzahlungsbürgschaften in Höhe von 2,5 Mio. €. Diese Linie kann von der SÜSS MicroTec AG, der SÜSS MicroTec Lithography GmbH oder der SÜSS MicroTec Reman GmbH in Anspruch genommen werden.

Zum Bilanzstichtag sind die Linien in Höhe von 5.443 Tsd. € (Vorjahr: 3.484 Tsd. €) in Form von Avalen genutzt.

Der durchschnittliche Zinssatz für die Inanspruchnahme der Kreditlinien in Form von Avalen betrug 1,00 % (Vorjahr: 1,09 %).

VERBINDLICHKEITEN AUS FINANCE LEASE

Der Konzern least derzeit diverse Einrichtungen und Ausrüstungsgegenstände sowohl im Fertigungs- als auch im Verwaltungsbereich unter Operating Lease-Verträgen. Darüber hinaus bestehen bezüglich Software, Gebäuden, Grundstücken und Einbauten, technischen Anlagen und Maschinen sowie anderen Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Finance Lease-Verträge, deren zugrunde liegende Vermögenswerte aktiviert und planmäßig abgeschrieben werden.

Die Fristigkeit der Leasingverbindlichkeiten sowie die künftigen finanziellen Verpflichtungen aus Operating Lease stellen sich wie folgt dar:

in Tsd. €	Finance Lease	Operating Lease
Abschreibungen / Aufwendungen 2015	7	1.262
Abschreibungen / Aufwendungen 2014	11	1.190
Künftige Verpflichtungen fällig		
2016	0	895
2017	0	657
2018	0	106
2019	0	27
2020	0	2
später	0	0
Gesamt zukünftig	0	1.687
Zinsanteil	0	
Verbindlichkeit 31.12.2015	0	
davon kurzfristig	0	
davon langfristig	0	

(26) (Kurzfristige) Rückstellungen

Die kurzfristigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

in Tsd. €	2015	2014
Garantierückstellungen	1.574	1.434
Rückstellungen für Abfindungen	0	1.050
Übrige Rückstellungen	788	754
Kurzfristige Rückstellungen	2.362	3.238

Die Garantierückstellungen wurden für gesetzliche und vertraglich vereinbarte Garantien und Gewährleistungsansprüche von Kunden aus Maschinenlieferungen in Höhe der wahrscheinlichen Inanspruchnahme gebildet.

Die im Vorjahr ausgewiesene Rückstellung für Abfindungen betraf in voller Höhe ein ausgeschiedenes Vorstandsmitglied.

Die übrigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen Rückstellungen für Nachlaufkosten sowie Personalrückstellungen.

Die kurzfristigen Rückstellungen haben sich wie folgt entwickelt:

in Tsd. €	Stand 01.01.15	Verbrauch	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.15
Garantierückstellungen	1.434	-1.434	0	1.574	1.574
Abfindungen	1.050	-1.050	0	0	0
Übrige Rückstellungen	754	-678	-76	788	788
Kurzfristige Rückstellungen	3.238	-3.162	-76	2.362	2.362

(27) Sonstige (kurzfristige) finanzielle Verbindlichkeiten

Die sonstigen kurzfristigen finanziellen Verbindlichkeiten teilen sich wie folgt auf:

in Tsd. €	2015	2014
Prämien und Provisionen	3.886	2.684
Fremdleistungen	1.266	1.566
Aufsichtsratsvergütung	188	159
Negative Marktwerte aus Zinsswaps	411	488
Devisentermingeschäfte	34	0
Bedingte Kaufpreisverpflichtung SMO	92	163
noch abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	449	527
Lizenzgebühren	99	70
Sonstiges	120	150
Sonstige (kurzfristige) finanzielle Verbindlichkeiten	6.545	5.807

Die Gesellschaft weist unter den sonstigen finanziellen Verbindlichkeiten die negativen Marktwerte der Zinsderivate aus. Weitere Einzelheiten zu den Zinssicherungsgeschäften finden sich in Textziffer 30 „Zusätzliche Informationen über Finanzinstrumente“.

(28) Sonstige (kurzfristige) Verbindlichkeiten

Die sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten teilen sich wie folgt auf:

in Tsd. €	2015	2014
Erhaltene Anzahlungen	18.176	17.964
Abgegrenzte Personalkosten	4.394	3.826
Passive Rechnungsabgrenzung	366	233
Umsatzsteuer	228	569
Sonstiges	302	200
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	23.466	22.792

Die erhaltenen Anzahlungen enthalten alle Kundenanzahlungen für Maschinen vor der endgültigen Abnahme. Nach erfolgter Abnahme und entsprechender Umsatzrealisierung werden die Anzahlungen mit den entstandenen Forderungen verrechnet.

In den abgegrenzten Personalkosten sind im Wesentlichen Verpflichtungen für Urlaubsrückstände und Gleitzeitguthaben enthalten.

(29) Steuerschulden

Die Steuerverbindlichkeiten enthalten inländische Ertragsteuern in Höhe von 2.787 Tsd. € (Vorjahr: 991 Tsd. €) und ausländische Ertragsteuern in Höhe von 540 Tsd. € (Vorjahr: 504 Tsd. €).

Sonstige Angaben

(30) Zusätzliche Informationen über Finanzinstrumente

Unter Finanzinstrumente fallen nach IAS 32 grundsätzlich sämtliche auf vertraglicher Basis vorgenommene wirtschaftliche Vorgänge, die einen Anspruch auf Zahlungsmittel beinhalten. Hierzu gehören einerseits originäre Finanzinstrumente wie Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie andererseits Finanzforderungen und -verbindlichkeiten. Weiterhin umfassen die Finanzinstrumente auch derivative Instrumente, die zur Sicherung von Währungs- und Zinsänderungsrisiken eingesetzt werden. Die geschätzten Marktwerte der Finanzinstrumente stellen nicht notwendigerweise die Werte dar, die das Unternehmen bei einer tatsächlichen Transaktion unter aktuellen Marktbedingungen realisieren würde. Folgender Abschnitt gibt einen umfassenden Überblick über die Bedeutung von Finanzinstrumenten für das Unternehmen und liefert zusätzliche Informationen über Bilanzpositionen, die Finanzinstrumente enthalten.

Die folgende Tabelle zeigt die Buchwerte aller Kategorien von finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten:

in Tsd. €	2015	2014
Finanzielle Vermögenswerte		
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	49.085	47.309
Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte	0	1.026
Kredite und Forderungen	13.314	13.594
Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte	0	0
	62.399	61.929
Finanzielle Verbindlichkeiten		
Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten	445	488
Finanzielle Verbindlichkeiten	23.711	19.101
	24.156	19.589

Die folgende Tabelle stellt die Marktwerte sowie die Buchwerte der finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten dar.

	2015		Bewertungskategorien gem. IAS 39
	Buchwert	Marktwert	
Finanzielle Vermögenswerte			
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	49.085	49.085	Kredite und Forderungen
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.093	13.093	Kredite und Forderungen
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	221	221	Kredite und Forderungen
bewertet zu fortgeführten Anschaffungskosten	221	221	Kredite und Forderungen
bewertet zum Marktwert	0	0	Kredite und Forderungen
Finanzielle Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.472	8.472	Fortgeführte Anschaffungskosten
Finanzschulden	9.106	10.266	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.100	10.260	Fortgeführte Anschaffungskosten
Verbindlichkeiten aus Finance Lease	6	6	Fortgeführte Anschaffungskosten
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	6.578	6.578	
bewertet zu fortgeführten Anschaffungskosten	6.133	6.133	Fortgeführte Anschaffungskosten
bewertet zum Marktwert (Fair Value Stufe 2)	445	445	Derivate

	2014		Bewertungskategorien gem. IAS 39
	Buchwert	Marktwert	
Finanzielle Vermögenswerte			
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	47.309	47.309	Kredite und Forderungen
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.390	13.390	Kredite und Forderungen
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	204	204	Kredite und Forderungen
bewertet zu fortgeführten Anschaffungskosten	204	204	Kredite und Forderungen
bewertet zum Marktwert	0	0	Kredite und Forderungen
Wertpapiere, bewertet zum Marktwert (Fair Value Stufe 1)	1.026	1.026	Zur Veräußerung verfügbar
Finanzielle Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.446	3.446	Fortgeführte Anschaffungskosten
Finanzschulden	10.287	11.769	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.280	11.762	Fortgeführte Anschaffungskosten
Verbindlichkeiten aus Finance Lease	7	7	Fortgeführte Anschaffungskosten
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	5.856	5.856	
bewertet zu fortgeführten Anschaffungskosten	5.368	5.368	Fortgeführte Anschaffungskosten
bewertet zum Marktwert (Fair Value Stufe 2)	488	488	Derivate

Für die Ermittlung der Marktwerte werden die folgenden Methoden verwendet und Annahmen getroffen:

ZAHLUNGSMITTEL UND ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTE

Die Buchwerte entsprechen aufgrund der Kurzfristigkeit der Anlagen den Marktwerten der Instrumente.

FORDERUNGEN/VERBINDLICHKEITEN AUS LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN

Die Buchwerte entsprechen aufgrund der Kurzfristigkeit der Forderungen und Verbindlichkeiten annäherungsweise den Marktwerten der Instrumente.

SONSTIGE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE/VERBINDLICHKEITEN

Die Buchwerte der zu fortgeführten Anschaffungskosten bewerteten sonstigen finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten entsprechen aufgrund der Kurzfristigkeit der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in etwa dem Marktwert.

Die Bewertung der sonstigen finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die zu Marktwerten bewertet werden, hängt von ihrem Typ ab. Der Marktwert von Devisentermingeschäften bestimmt sich in Abhängigkeit von Devisenterminkursen. Der Marktwert von Zinsderivaten bestimmt sich durch Abzinsung der erwarteten zukünftigen Zahlungsströme über die Restlaufzeit des Kontrakts auf der Basis aktueller Marktzinsen und der Zinsstrukturkurve.

WERTPAPIERE

Der Marktwert der zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerte entspricht dem Kurswert in einem aktiven Markt.

VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER KREDITINSTITUTEN

Der Marktwert der Finanzverbindlichkeiten betreffend die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten wurde durch Diskontierung des erwarteten Mittelabflusses zu den marktüblichen Zinssätzen für Schuldtitel mit vergleichbaren Konditionen und Restlaufzeiten ermittelt.

VERBINDLICHKEITEN AUS FINANCE LEASE

Der Marktwert der Verbindlichkeiten aus Finance Lease wurde durch Diskontierung des erwarteten Mittelabflusses zu den marktüblichen Zinssätzen für Schuldtitel mit vergleichbaren Konditionen und Restlaufzeiten ermittelt.

Die Nettogewinne bzw. -verluste aus Finanzinstrumenten haben sich wie folgt entwickelt:

in Tsd. €	2015	2014
Kredite und Forderungen	-317	1.236
Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte	-22	-47

Nettogewinne bzw. -verluste aus Krediten und Forderungen enthalten Veränderungen in den Wertberichtigungen, Gewinne und Verluste aus der Ausbuchung sowie Zahlungseingänge auf ursprünglich abgeschriebene Darlehen und Forderungen.

Im Berichtsjahr wurde die während der Laufzeit im kumulierten übrigen Eigenkapital – nach der Berücksichtigung latenter Steuern – erfasste Marktwertveränderung der zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerte in Höhe von -11 Tsd. € (Vorjahr: -28 Tsd. €) infolge der Endfälligkeit dieser Wertpapiere aus dem Eigenkapital in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert.

DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE

Im Rahmen des Risikomanagements werden derivative Finanzinstrumente eingesetzt, um Wechselkursschwankungen und Zinsrisiken zu begrenzen.

Die direkten Marktwerte der einzelnen Arten von derivativen Finanzinstrumenten haben sich wie folgt entwickelt:

in Tsd. €	2015		2014	
	positiver Marktwert	negativer Marktwert	positiver Marktwert	negativer Marktwert
Devisentermingeschäfte	0	34	0	0
Zinsswaps	0	411	0	488

Einkaufs- und Verkaufsverpflichtungen in Fremdwährungen entstehen durch grenzübergreifende Lieferbeziehungen zwischen den SÜSS MicroTec-Gesellschaften aus dem Euroraum und externen Kunden oder Lieferanten, die nicht im Euroraum ansässig sind. Dies betrifft vor allem Kunden oder Lieferanten in den Währungsräumen des US-Dollars und des japanischen Yen, die Produkte von SÜSS MicroTec-Gesellschaften aus dem Euro-Währungsraum beziehen oder an diese verkaufen. Zum Zeitpunkt der Erteilung des Auftrages werden Devisentermingeschäfte abgeschlossen, um Währungsveränderungen bis zum Zeitpunkt der Bezahlung abzusichern. Da zum Zeitpunkt des Abschlusses das Grundgeschäft selbst noch nicht vorliegt und erst mit Umsatzrealisierung entsteht, handelt es sich um die Absicherung geplanter Transaktionen. Die Veränderung der Marktwerte weist das Unternehmen unter den sonstigen betrieblichen Erträgen bzw. sonstigen betrieblichen Aufwendungen aus. Die

potenziellen Risiken liegen einerseits in der Fluktuation der Währungskurse und andererseits im Bonitätsrisiko der Gegenpartei, die ausschließlich aus deutschen Kreditinstituten erstklassiger Bonität besteht.

Zum 31. Dezember 2015 besteht ein offenes Devisentermingeschäft über den Terminverkauf von 175 Mio. JPY mit Valuta 29. Februar 2016. Der Sicherungskurs beläuft sich auf 134,6159 JPY/Euro.

Die Fremdwährungssensitivität wird durch die Aggregation der Fremdwährungspositionen des operativen Geschäfts und des Konzern-Treasury ermittelt. Dabei werden die Fremdwährungsrisiken durch Simulation einer zehnpromtigen Abwertung aller Fremdwährungen gegenüber dem Euro berechnet. Diese simulierte Abwertung hätte zum Bilanzstichtag zu einer Reduzierung der Euro-Gegenwerte in Höhe von 149 Tsd. € (Vorjahr: Reduzierung um 217 Tsd. €) und einer entsprechenden Verringerung (Vorjahr: Verringerung) des Jahresergebnisses geführt.

Die folgenden Tabellen zeigen die Zusammensetzung des Fremdwährungsexposures und die Auswirkungen auf das Jahresergebnis zum Bilanzstichtag und zum Vorjahresstichtag:

in Tsd. €	2015		
	USD	JPY	Summe
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2.058	10	2.068
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	621	17	638
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-574	-17	-591
Kundenanzahlungen	-476	0	-476
Netto-Exposure	1.629	10	1.639
Effekt auf das Jahresergebnis bei 10%iger Aufwertung des Euro	-148	-1	-149

in Tsd. €	2014		
	USD	JPY	Summe
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2.045	3.065	5.110
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.545	786	3.331
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-938	-230	-1.168
Kundenanzahlungen	-4.889	-2	-4.891
Netto-Exposure	-1.237	3.619	2.382
Effekt auf das Jahresergebnis bei 10%iger Aufwertung des Euro	112	-329	-217

Das Unternehmen ist bestrebt, Zinsrisiken, die sich aus der Sensitivität von Finanzschulden in Bezug auf Schwankungen des Marktzinsniveaus ergeben können, durch den Einsatz von Zinsderivaten wie Zinsswaps zu begrenzen. So hat die Gesellschaft den variablen Zins des 2010 aufgenommenen Darlehens, das der Finanzierung des Grundstücks Sternenfels dient, mit einem laufzeitkongruenten Swap gesichert. Der Zinsswap gleicht die Auswirkungen zukünftiger Veränderungen der Zinssätze auf die Zahlungsströme der zugrunde liegenden variabel verzinslichen Anlage aus. Um die Marktwertschwankungen des Zinsswaps für das Grundstücksdarlehen im kumulierten übrigen Eigenkapital abzubilden, hat die Gesellschaft für diesen Zinsswap Hedge Accounting angewendet. Der Zinsswap im Zusammenhang mit der Grundstücksfinanzierung weist eine Laufzeit bis zum 30. Juni 2020 auf.

(31) Nahestehende Personen

Nach IAS 24 müssen Personen angegeben werden, die die SÜSS MicroTec AG beherrschen oder von ihr beherrscht werden, soweit sie nicht bereits in den Konzernabschluss einbezogen wurden.

Beherrschung liegt vor, wenn ein Aktionär mehr als die Hälfte der Stimmrechte der SÜSS MicroTec AG hält oder kraft Satzung oder vertraglicher Vereinbarung die Möglichkeit besitzt, die Finanz- und Geschäftspolitik der SÜSS MicroTec AG zu steuern.

Darüber hinaus erstreckt sich die Angabepflicht nach IAS 24 auf Geschäfte mit Joint Ventures sowie auf Geschäfte mit Personen, die einen maßgeblichen Einfluss auf die Finanz- und Geschäftspolitik der SÜSS MicroTec AG ausüben, einschließlich naher Familienangehöriger oder zwischengeschalteter Unternehmen. Ein maßgeblicher Einfluss auf die Finanz- und Geschäftspolitik des Konzerns kann hierbei auf einem Anteilsbesitz an der SÜSS MicroTec AG von 20 % oder mehr, einem Sitz im Vorstand oder Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec AG oder einer anderen Schlüsselposition im Management beruhen.

Im Geschäftsjahr wurde der Konzern von den Angabepflichten nach IAS 24 „Angaben über Beziehungen zu nahe stehenden Unternehmen und Personen“ – mit Ausnahme der Angaben zur Vergütung der Organe – nicht berührt.

(32) Finanzielle Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

in Tsd. €	2015	2014
Bestellobligo	19.540	13.543
Mietverpflichtungen	1.014	926
Summe	20.554	14.469

Das Bestellobligo verpflichtet das Unternehmen zu einer späteren Abnahme von Fremdleistungen oder Materialien.

(33) Erläuterungen zur Konzernkapitalflussrechnung

In der Konzernkapitalflussrechnung des SÜSS MicroTec-Konzerns wird entsprechend IAS 7 („Cashflow Statements“) zwischen Zahlungsströmen aus betrieblicher Geschäftstätigkeit und aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit unterschieden.

Der in der Kapitalflussrechnung betrachtete Finanzmittelfonds umfasst alle in der Bilanz ausgewiesenen flüssigen Mittel, d. h. Kassenbestände, Schecks und Guthaben bei Kreditinstituten, soweit sie innerhalb von drei Monaten ohne nennenswerte Wertschwankungen verfügbar sind. Im Berichtsjahr diente ein Betrag von 350 Tsd. € (Vorjahr: 350 Tsd. €) der ausgewiesenen flüssigen Mittel zum Bilanzstichtag als Sicherheit für einen Kautionsversicherungsvertrag. Dieser Betrag kann jederzeit durch die Stellung einer Rückbürgschaft abgelöst werden.

Die Cashflows aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit werden zahlungsbezogen ermittelt. Demgegenüber wird der Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit ausgehend vom Jahresergebnis indirekt abgeleitet.

Im Rahmen der indirekten Ermittlung werden die berücksichtigten Veränderungen von Bilanzpositionen um Effekte aus der Währungsumrechnung bereinigt. Die Veränderungen der betreffenden Bilanzpositionen können daher nicht mit den entsprechenden Werten auf Grundlage der Konzernbilanzen abgestimmt werden.

Die sonstigen nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen in Höhe von -1.370 Tsd. € (Vorjahr: -340 Tsd. €) beinhalten im Wesentlichen Währungseffekte. Für das Vorjahr sind hier außerdem die Effekte aus der Zuführung zu einer Rückstellung für Abfindungen in Höhe von 1.050 Tsd. € enthalten.

(34) Segmentberichterstattung

INFORMATIONEN ZU DEN SEGMENTEN

Die Aktivitäten des SÜSS MicroTec-Konzerns werden im Rahmen der Segmentberichterstattung gemäß den Regeln von IFRS 8 („Operating Segments“) nach Produktlinien und nach Regionen abgegrenzt. Diese Aufgliederung orientiert sich an der internen Steuerung und Berichterstattung an den Vorstand und berücksichtigt die unterschiedlichen Risiko- und Ertragsstrukturen der Segmente.

Die Aktivitäten des SÜSS MicroTec-Konzerns werden in die operativen Segmente Lithografie, Substrat Bonder und Fotomaschinen Equipment aufgeteilt. Im Segment Sonstige werden weitere Aktivitäten des Konzerns sowie die nicht zuordenbaren Kosten der Konzernfunktionen gebündelt.

Im Segment Lithografie entwickelt, produziert und vertreibt der SÜSS MicroTec-Konzern die Produktlinien Mask Aligner, Entwickler und Belacker sowie die Produktlinien UV Projection und Laser Processing. Die Entwicklungs- und Produktionsaktivitäten sind in Deutschland an den Standorten Garching bei München und Sternenfels bei Stuttgart angesiedelt. Die Entwicklung und Produktion der Produktlinien UV Projection und Laser Processing erfolgt in Corona (USA). Darüber hinaus sind wesentliche Teile der Vertriebsorganisationen in Nordamerika und Asien für das Segment Lithografie tätig. Die Lithografie stellt deutlich mehr als die Hälfte des Gesamtgeschäftes der Gruppe dar und ist in den Märkten Advanced Packaging, MEMS und Verbindungshalbleiter vertreten.

Im Segment Substrat Bonder sind die Entwicklung, Produktion und der Vertrieb der Produktlinie Substrat Bonder ausgewiesen. Die Aktivitäten in diesem Segment sind in Sternenfels bei Stuttgart konzentriert. Der Vertrieb für das Segment Substrat Bonder ist über Sternenfels hinaus weltweit in kleinen Einheiten an Standorten in Europa, in den USA und in Asien ansässig.

Das Segment Fotomaschinen Equipment umfasst die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb der Produktlinien HMx, ASx, MaskTrack und MaskTrack Pro der SÜSS MicroTec Photomask Equipment GmbH & Co. KG. Die Entwicklung und Produktion der auf die Reinigung und Prozessierung von Fotomaschinen für die Halbleiter-Industrie spezialisierten Systeme ist am Standort Sternenfels angesiedelt.

Im Segment Sonstige werden neben den nicht zuordenbaren Kosten der SÜSS MicroTec AG die operativen, nicht den Segmenten zugeordneten Aktivitäten im Bereich Mikrooptik gezeigt.

SONSTIGE ERLÄUTERUNGEN ZUR SEGMENTBERICHTERSTATTUNG

Die Segmentdaten wurden auf der Grundlage der im Konzernabschluss angewendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ermittelt. In Folge der gesellschaftsübergreifenden Segmentierung des Konzerns nach Produktlinien treten grundsätzlich keine wesentlichen intersegmentären Transaktionen auf. Eine Ausnahme bilden die Weiterbelastungen der SÜSS MicroTec AG, die im Segment Sonstige erfasst sind, an die anderen Segmente für die Wahrnehmung bestimmter Konzernfunktionen wie Finanzierungs- und Strategiefragen. Diese Weiterbelastungen enthalten auch die in der Holding angefallenen Aufwendungen im Zusammenhang mit der Einführung und dem Systembetrieb von SAP.

Um den Anforderungen des IFRS 8 „Segmentberichterstattung“ zu entsprechen, enthält die Segmentberichterstattung die Angabe eines Vorsteuerergebnisses je Segment. Damit ist die Überleitung der Summe der Segmentergebnisse zum Gesamtkonzernergebnis vor Steuern möglich.

Im Geschäftsjahr hat SÜSS MicroTec mit einem Kunden Umsätze von rund 23,8 Mio. € erzielt, das sind rund 16 % des Gesamtumsatzes. Die Umsätze mit diesem Kunden entfallen mit rund 23,2 Mio. € auf das Segment Lithografie; 0,6 Mio. € sind dem Segment Fotomaschinen Equipment zuzuordnen. Im Vorjahr lagen sämtliche Umsätze von SÜSS MicroTec mit einzelnen Kunden unter einem Anteil von 10 % des Gesamtumsatzes.

Unter den wesentlichen nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträgen werden neben den Wertberichtigungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Abwertungen auf das Vorratsvermögen auch die Zuführung zu und die Auflösung von Rückstellungen und sonstigen Verpflichtungen gezeigt.

Das Segmentvermögen stellt das betriebsnotwendige Vermögen der einzelnen Segmente dar. Es umfasst die immateriellen Vermögenswerte inklusive Geschäfts- oder Firmenwert, die Sachanlagen sowie das Vorratsvermögen und die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.

In den Segmentschulden sind die operativen Schulden und Rückstellungen der einzelnen Segmente enthalten.

Bei den Investitionen handelt es sich um Zugänge von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen.

Für die geografische Segmentberichterstattung werden die Umsatzerlöse nach dem Standort der Kunden segmentiert. SÜSS MicroTec hat im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsätze in Höhe von 18.552 Tsd. € (Vorjahr: 18.388 Tsd. €) in Deutschland erzielt.

Das Vermögen und die Investitionen wurden auf der Grundlage des Standortes der jeweiligen Konzerngesellschaft ermittelt. Das langfristige Vermögen des Konzerns besteht im Wesentlichen aus immateriellen Vermögenswerten, Geschäfts- oder Firmenwerten und Sachanlagen. Vom langfristigen Vermögen sind 32.340 Tsd. € (Vorjahr: 32.297 Tsd. €) Gesellschaften in Deutschland zuzurechnen; 7.961 Tsd. € (Vorjahr: 7.918 Tsd. €) entfallen auf ausländische Gesellschaften. Der SÜSS MicroTec-Konzern hat im abgelaufenen Geschäftsjahr Investitionen in Höhe von 2.075 Tsd. € (Vorjahr: 2.242 Tsd. €) in Deutschland vorgenommen.

(35) Nachtragsbericht

Wesentliche Ereignisse nach dem Stichtag, die einen signifikanten Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- oder Ertragslage des Konzerns haben, haben sich nicht ergeben.

(36) Vorstand und Aufsichtsrat

VORSTAND DER KONZERNBEREITSCHAFT Mitglieder des Vorstandes der SÜSS MicroTec AG im Geschäftsjahr 2015 waren:

DR. PER-OVE HANSSON (SEIT 1. MAI 2015)

Dr. rer. nat. (Physik), Feldkirchen, Vorstandsvorsitzender

ZUSTÄNDIGKEITSBEREICHE:

Marketing und Vertrieb, Konzernstrategie, Service, Forschung und Entwicklung, Patentwesen, Divisions/Produktlinien

WEITERE MANDATE:

- keine

MICHAEL KNOPP

Diplom-Kaufmann, Ratingen, Finanzvorstand,
Vorstandssprecher bis 30. April 2015

ZUSTÄNDIGKEITSBEREICHE:

Finanz- und Rechnungswesen, IT, Recht, Steuern und Versicherungen, Personal, Facility Management, Investor Relations. Bis 30. April 2015 zusätzlich Marketing und Vertrieb, Service, Konzernstrategie

WEITERE MANDATE:

- keine

WALTER BRAUN

Diplom-Ingenieur, Altensteig, Mitglied des Vorstands

ZUSTÄNDIGKEITSBEREICHE:

Produktion, Arbeitssicherheit, Qualitätsmanagement, Umweltschutz, Materialwirtschaft und Logistik.
Bis 30. April 2015 zusätzlich Patentwesen,
Konzernstrategie, Forschung und Entwicklung

WEITERE MANDATE:

- keine

AUFSICHTSRAT

Mitglieder des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2015 waren:

DR. STEFAN REINECK

Kirchartd, Geschäftsführender Gesellschafter der RMC
Dr. Reineck Management & Consulting GmbH, Kirchartd;
Aufsichtsratsvorsitzender der SÜSS MicroTec AG

WEITERE MANDATE:

- AttoCube Systems AG, München
(Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats)
- AWS-Group AG, Heilbronn (Mitglied im Aufsichtsrat)
- Phoseon Technology Inc., Hillsboro, Oregon, USA
(Mitglied im „Board of Directors“)
- Wittenstein AG, Igersheim (Mitglied im Aufsichtsrat)
- seit 26. Oktober 2015 Accel 4.0 Beteiligungs GmbH,
Heilbronn (Beiratsvorsitzender)

JAN TEICHERT

Metten, Mitglied des Vorstands der Einhell Germany AG,
Landau, Isar; Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats
der SÜSS MicroTec AG

WEITERE MANDATE:

- bis 31. Mai 2015 Kolb Technology GmbH, Hengersberg
(Mitglied des Beirats)

GERHARD PEGAM

Au bei Bad Aibling, Geschäftsführender Gesellschafter der
GPA Consulting, Au bei Bad Aibling; Aufsichtsratsmitglied
der SÜSS MicroTec AG

WEITERE MANDATE:

- OC Oerlikon Corporation AG, Pfäffikon, Schweiz
(Mitglied des Verwaltungsrats)
- Schaffner Holding AG, Solothurn, Schweiz
(Mitglied des Verwaltungsrats)

VERGÜTUNG VORSTAND UND AUFSICHTSRAT

Die Mitglieder des Vorstands erhielten eine Barvergütung in Höhe von 1.568 Tsd. € (Vorjahr: 2.173 Tsd. €). Der Betrag der Vorstandsvergütung des Vorjahres enthielt eine Abfindung in Höhe von 1.050 Tsd. € für den damaligen Vorstandsvorsitzenden, Frank Averdung, der am 24. August 2014 ausgeschieden ist.

Die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats betrug einschließlich Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen 188 Tsd. € (Vorjahr: 159 Tsd. €).

Individualisierte Angaben zur Vergütung des Vorstands und des Aufsichtsrats sind im Vergütungsbericht, der Bestandteil des zusammengefassten Lageberichts ist, dargestellt.

Aktien- und Optionsbestände der Organmitglieder zum Jahresende:

	2015		2014	
	Aktien	Optionen	Aktien	Optionen
Michael Knopp	18.350	0	25.000	0
Walter Braun	3.150	0	10.500	0
Dr. Per-Ove Hansson	0	0	–	0
Dr. Stefan Reineck	9.600	0	9.600	0

(37) Mitarbeiter

Im Geschäftsjahr waren durchschnittlich 686 Mitarbeiter (Vorjahr: 651 Mitarbeiter) in der SÜSS MicroTec-Gruppe beschäftigt.

Stand am Jahresende:

	2015	2014
Verwaltung	61	66
Marketing und Vertrieb	262	249
Produktion und Technik	375	344
Summe	698	659

(38) Honorare des Abschlussprüfers

Im aktuellen Geschäftsjahr hat SÜSS MicroTec für den Abschlussprüfer des Konzernabschlusses, BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, Honoraraufwendungen nach § 314 Abs. 1 Nr. 9 HGB in Höhe von 267 Tsd. € (Vorjahr: 260 Tsd. €) erfasst. Die Aufwendungen betreffen ausschließlich die Abschlussprüfung.

Die Aufwendungen für die Abschlussprüfung enthalten das gesamte Honorar für die Jahresabschlussprüfung der SÜSS MicroTec AG sowie die Konzernabschlussprüfung und die durch die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüften Jahresabschlüsse von Tochtergesellschaften. Von dem Prüfungshonorar entfallen 227 Tsd. € direkt auf den bestellten Abschlussprüfer und 40 Tsd. € auf Netzwerkpartner des Abschlussprüfers.

Beratungsleistungen wurden durch die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft weder im Geschäftsjahr noch im Vorjahr erbracht.

(39) Corporate Governance

Wie bereits in den Vorjahren haben Vorstand und Aufsichtsrat im Januar 2015 eine Entsprechenserklärung gemäß § 161 AktG abgegeben und erklärt, dass sie den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance-Kodex in der Fassung vom 24. Juni 2014 mit folgenden Ausnahmen – Selbstbehalt bei der D&O-Versicherung, vertikaler Vergütungsvergleich, Versorgungszusagen, Bildung von Ausschüssen und Ziele für die Zusammensetzung des Aufsichtsrats – entsprechen werden und den Empfehlungen des Kodex in der Fassung vom 13. Mai 2013 seit der Abgabe der letzten jährlichen Entsprechenserklärung im Januar 2014 mit den darin angegebenen Ausnahmen entsprechen haben.

Im Januar 2016 haben Vorstand und Aufsichtsrat eine Entsprechenserklärung gemäß § 161 AktG abgegeben und erklärt, dass sie den Empfehlungen der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance-Kodex in der Fassung vom 5. Mai 2015 mit folgenden Ausnahmen – Selbstbehalt bei D&O-Versicherungen, vertikaler Vergütungsvergleich, Versorgungszusagen, Bildung von Ausschüssen und Festlegung einer Regelgrenze für die Zugehörigkeitsdauer im Aufsichtsrat – entsprechen werden. Ferner haben Vorstand und Aufsichtsrat erklärt, dass sie den Empfehlungen des Kodex in der Fassung vom 24. Juni 2014 seit der Abgabe der letzten jährlichen Entsprechenserklärung im Januar 2015 mit den darin angegebenen Ausnahmen entsprechen haben.

Die Entsprechenserklärungen wurden im Internet unter [► www.suss.com](http://www.suss.com) dauerhaft zugänglich gemacht.

(40) Angabe gemäß § 160 Nr. 8 AktG

Im Geschäftsjahr wurden gegenüber der Gesellschaft folgende Mitteilungen gemäß § 21 Abs. 1 WpHG i.V.m. § 32 Abs. 2 InvG gemacht:

Die Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main, Deutschland, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 8. Januar 2015 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 2. Januar 2015 die Schwelle von 3 % überschritten hat und zu diesem Tag 4,44 % beträgt (848.291 Stimmrechte). Davon sind ihr 1,59 % (304.356 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG und 2,57 % (492.000 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG in Verbindung mit § 22 Abs. 1 Satz 2 zuzurechnen.

Die Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main, Deutschland, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 3. Februar 2015 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 30. Januar 2015 die Schwelle von 5 % überschritten hat und zu diesem Tag 5,04 % beträgt (964.360 Stimmrechte). Davon sind ihr 2,32 % (444.356 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG und 2,62 % (500.000 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG in Verbindung mit § 22 Abs. 1 Satz 2 zuzurechnen.

Die Schroders PLC, London, Großbritannien, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 4. Februar 2015 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 3. Februar 2015 die Schwelle von 3 % unterschritten hat und zu diesem Tag 2,96 % beträgt (564.820 Stimmrechte). Davon sind ihr 2,96 % (564.820 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG in Verbindung mit § 22 Abs. 1 Satz 2 zuzurechnen.

Die Schroder Administration Limited, London, Großbritannien, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 4. Februar 2015 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 3. Februar 2015 die Schwelle von 3 % unterschritten hat und zu diesem Tag 2,96 % beträgt (564.820 Stimmrechte). Davon sind ihr 2,96 % (564.820 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG in Verbindung mit § 22 Abs. 1 Satz 2 zuzurechnen.

Die Schroder Investment Management Ltd, London, Großbritannien, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 4. Februar 2015 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, 3. Februar 2015 die Schwelle von 3 % unterschritten hat und zu diesem Tag 2,96 % beträgt (564.820 Stimmrechte). Davon sind ihr 1,34 % (256.507 Stimmrechte)

nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG und 1,61 % (308.313 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG in Verbindung mit § 22 Abs. 1 Satz 2 zuzurechnen.

Der Vanguard Whitehall Funds, Delaware, USA, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 10. Februar 2015 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 5. Februar 2015 die Schwelle von 3 % unterschritten hat und zu diesem Tag 2,919 % beträgt (558.034 Stimmrechte).

Die Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main, Deutschland, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 18. Februar 2015 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 13. Februar 2015 die Schwelle von 5 % unterschritten hat und zu diesem Tag 4,89 % beträgt (933.859 Stimmrechte). Davon sind ihr 2,37 % (453.856 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG und 2,51 % (479.965 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG in Verbindung mit § 22 Abs. 1 Satz 2 zuzurechnen.

Die ING Groep N.V. Amsterdam, Niederlande, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 21. April 2015 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 15. April 2015 die Schwelle von 3 % überschritten hat und zu diesem Tag 3,43 % beträgt (656.497 Stimmrechte). Diese 3,43 % (656.497 Stimmrechte) werden der Gesellschaft nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG in Verbindung mit § 22 Abs. 1 Satz 2 und gleichzeitig nach § 22 Abs. 2 WpHG zugerechnet.

Die NN Group N.V. (vormals: ING Insurance Topholding N.V.), Amsterdam, Niederlande, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 21. April 2015 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 15. April 2015 die Schwelle von 3 % überschritten hat und zu diesem Tag 3,43 % beträgt (656.497 Stimmrechte). Diese 3,43 % (656.497 Stimmrechte) werden der Gesellschaft nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG in Verbindung mit § 22 Abs. 1 Satz 2 und gleichzeitig nach § 22 Abs. 2 WpHG zugerechnet.

Die NN Insurance Eurasia N.V. (vormals: ING Insurance Eurasia N.V.), Amsterdam, Niederlande, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 21. April 2015 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 15. April 2015 die Schwelle von 3 % überschritten hat und zu diesem Tag 3,43 % beträgt (656.497 Stimmrechte). Diese 3,43 % (656.497 Stimmrechte) werden der Gesellschaft nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG in Verbindung mit § 22 Abs. 1 Satz 2 und gleichzeitig nach § 22 Abs. 2 WpHG zugerechnet.

Die NN Investment Partners Holdings N.V. (vormals: ING Investment Management Holdings N.V.), Den Haag, Niederlande, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 21. April 2015 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 15. April 2015 die Schwelle von 3 % überschritten hat und zu diesem Tag 3,43 % beträgt (656.497 Stimmrechte). Diese 3,43 % (656.497 Stimmrechte) werden der Gesellschaft nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG in Verbindung mit § 22 Abs. 1 Satz 2 und gleichzeitig nach § 22 Abs. 2 WpHG zugerechnet.

Die NN Investment Partners International Holdings B.V. (vormals: ING Investment Management (Europe) B.V.), Den Haag, Niederlande, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 21. April 2015 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 15. April 2015 die Schwelle von 3 % überschritten hat und zu diesem Tag 3,43 % beträgt (656.497 Stimmrechte). Diese 3,43 % (656.497 Stimmrechte) werden der Gesellschaft nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG in Verbindung mit § 22 Abs. 1 Satz 2 und gleichzeitig nach § 22 Abs. 2 WpHG zugerechnet.

Die NN Group N.V. (vormals: ING Insurance Topholding N.V.), Amsterdam, Niederlande hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 24. April 2015 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 21. April 2015 die Schwelle von 3 % unterschritten hat und zu diesem Tag 2,97 % beträgt (568.390 Stimmrechte). Diese 2,97 % (568.390 Stimmrechte) werden der Gesellschaft nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG in Verbindung mit § 22 Abs. 1 Satz 2 und gleichzeitig nach § 22 Abs. 2 WpHG zugerechnet.

Die NN Insurance Eurasia N.V. (vormals: ING Insurance Eurasia N.V.), Amsterdam, Niederlande hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 24. April 2015 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 21. April 2015 die Schwelle von 3 % unterschritten hat und zu diesem Tag 2,97 % beträgt (568.390 Stimmrechte). Diese 2,97 % (568.390 Stimmrechte) werden der Gesellschaft nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG in Verbindung mit § 22 Abs. 1 Satz 2 und gleichzeitig nach § 22 Abs. 2 WpHG zugerechnet.

Die NN Investment Partners Holdings N.V. (vormals: ING Investment Management Holdings N.V.), Den Haag, Niederlande hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 24. April 2015 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 21. April 2015 die Schwelle von 3 % unterschritten hat und zu diesem Tag 2,97 % beträgt (568.390 Stimmrechte). Diese 2,97 % (568.390 Stimmrechte) werden der Gesellschaft nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG in Verbindung mit § 22 Abs. 1 Satz 2 und gleichzeitig nach § 22 Abs. 2 WpHG zugerechnet.

Die NN Investment Partners International Holdings B.V. (vormals: ING Investment Management (Europe) B.V.), Den Haag, Niederlande hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 24. April 2015 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 21. April 2015 die Schwelle von 3 % unterschritten hat und zu diesem Tag 2,97 % beträgt (568.390 Stimmrechte). Diese 2,97 % (568.390 Stimmrechte) werden der Gesellschaft nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG in Verbindung mit § 22 Abs. 1 Satz 2 und gleichzeitig nach § 22 Abs. 2 WpHG zugerechnet.

Die NN Investment Partners B.V. (vormals: ING Fund Management B.V.), Den Haag, Niederlande hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 24. April 2015 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 21. April 2015 die Schwelle von 3 % unterschritten hat und zu diesem Tag 2,97 % beträgt (568.390 Stimmrechte). Von diesen Stimmrechten werden der Gesellschaft 2,03 % (388.176 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG und 0,94 % (180.214 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 2 WpHG zugerechnet.

Die NN Investment Partners Luxembourg S.A. (vormals: ING Investment Luxembourg S.A.), Luxemburg, Luxemburg hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 24. April 2015 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 21. April 2015 die Schwelle von 3 % unterschritten hat und zu diesem Tag 2,97 % beträgt (568.390 Stimmrechte). Von diesen Stimmrechten werden der Gesellschaft 0,94 % (180.214 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG und 2,03 % (388.176 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 2 WpHG zugerechnet.

Die NN Investment Partners Belgium S.A. (vormals: ING Investment Management Belgium S.A., Brüssel, Belgien hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 24. April 2015 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 21. April 2015 die Schwelle von 3 % unterschritten hat und zu diesem Tag 2,97 % beträgt (568.390 Stimmrechte). Diese 2,97 % (568.390 Stimmrechte) werden der Gesellschaft nach § 22 Abs. 2 WpHG zugerechnet.

Die ING Groep N.V. Amsterdam, Niederlande hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 24. April 2015 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 21. April 2015 die Schwelle von 3 % unterschritten hat und zu diesem Tag 2,97 % beträgt (568.390 Stimmrechte). Diese 2,97 % (568.390 Stimmrechte) werden der Gesellschaft nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG in Verbindung mit § 22 Abs. 1 Satz 2 und gleichzeitig nach § 22 Abs. 2 WpHG zugerechnet.

Die Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH, Düsseldorf, Deutschland hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 29. April 2015 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 28. April 2015 die Schwelle von 3 % überschritten hat und zu diesem Tag 3,10 % beträgt (592.719 Stimmrechte). Davon sind ihr 1,47 % (280.314 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG zuzurechnen.

KORREKTUR:

Die NN Investment Partners B.V. (vormals: ING Fund Management B.V.), Den Haag, Niederlande hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 7. Mai 2015 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 8. August 2014 die Schwelle von 3 % überschritten hat und zu diesem Tag 3,42 % beträgt (654.298 Stimmrechte). Von diesen Stimmrechten werden der Gesellschaft 2,35 % (448.348 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG und 1,08 % (205.950 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 2 WpHG zugerechnet.

Die NN Investment Partners Luxembourg S.A. (vormals: ING Investment Luxembourg S.A.), Luxemburg, Luxemburg hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 7. Mai 2015 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 8. August 2014 die Schwelle von 3 % überschritten hat und zu diesem Tag 3,42 % beträgt (654.298 Stimmrechte). Von diesen Stimmrechten werden der Gesellschaft 1,08 % (205.950 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG und 2,35 % (448.348 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 2 WpHG zugerechnet.

Die Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Frankfurt am Main, Deutschland, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 19. Mai 2015 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 13. Mai 2015 die Schwelle von 5 % überschritten hat und zu diesem Tag 5,32 % beträgt (1.017.394 Stimmrechte). Davon sind ihr 2,64 % (504.356 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG und 2,61 % (499.000 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG in Verbindung mit § 22 Abs. 1 Satz 2 zuzurechnen.

Die Henderson Group Holdings Asset Management Limited, London, UK, hat uns gemäß §21 Abs. 1 WpHG am 1. September 2015 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 5. Oktober 2012 die Schwelle von 3 % überschritten hat und zu diesem Tag 3,14 % beträgt (601.056 Stimmrechte). Davon sind ihr 3,14 % (601.056 Stimmrechte) nach §22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG in Verbindung mit §22 Abs. 1 Satz 2 zuzurechnen.

Die HGI Asset Management Group Limited, London, UK, hat uns gemäß §21 Abs. 1 WpHG am 1. September 2015 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 5. Oktober 2012 die Schwelle von 3 % überschritten hat und zu diesem Tag 3,14 % beträgt (601.056 Stimmrechte). Davon sind ihr 3,14 % (601.056 Stimmrechte) nach §22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG in Verbindung mit §22 Abs. 1 Satz 2 zuzurechnen.

Die Henderson Global Group Limited, London, UK, hat uns gemäß §21 Abs. 1 WpHG am 1. September 2015 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 5. Oktober 2012 die Schwelle von 3 % überschritten hat und zu diesem Tag 3,14 % beträgt (601.056 Stimmrechte). Davon sind ihr 3,14 % (601.056 Stimmrechte) nach §22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG in Verbindung mit §22 Abs. 1 Satz 2 zuzurechnen.

Die Henderson Holdings Group Limited, London, UK, hat uns gemäß §21 Abs. 1 WpHG am 1. September 2015 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 5. Oktober 2012 die Schwelle von 3 % überschritten hat und zu diesem Tag 3,14 % beträgt (601.056 Stimmrechte). Davon sind ihr 3,14 % (601.056 Stimmrechte) nach §22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG in Verbindung mit §22 Abs. 1 Satz 2 zuzurechnen.

Die HGI Group Limited, London, UK, hat uns gemäß §21 Abs. 1 WpHG am 1. September 2015 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 5. Oktober 2012 die Schwelle von 3 % überschritten hat und zu diesem Tag 3,14 % beträgt (601.056 Stimmrechte). Davon sind ihr 3,14 % (601.056 Stimmrechte) nach §22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG in Verbindung mit §22 Abs. 1 Satz 2 zuzurechnen.

Die Henderson Group Holdings Asset Management Limited, London, UK, hat uns gemäß §21 Abs. 1 WpHG am 1. September 2015 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 23. Januar 2014 die Schwelle von 5 % überschritten hat und zu diesem Tag 5,14 % beträgt (982.355 Stimmrechte). Davon sind ihr 5,14 % (982.355 Stimmrechte) nach §22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG in Verbindung mit §22 Abs. 1 Satz 2 zuzurechnen.

Die HGI Asset Management Group Limited, London, UK, hat uns gemäß §21 Abs. 1 WpHG am 1. September 2015 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 23. Januar 2014 die Schwelle von 5 % überschritten hat und zu diesem Tag 5,14 % beträgt (982.355 Stimmrechte). Davon sind ihr 5,14 % (982.355 Stimmrechte) nach §22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG in Verbindung mit §22 Abs. 1 Satz 2 zuzurechnen.

Die Henderson Global Group Limited, London, UK, hat uns gemäß §21 Abs. 1 WpHG am 1. September 2015 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 23. Januar 2014 die Schwelle von 5 % überschritten hat und zu diesem Tag 5,14 % beträgt (982.355 Stimmrechte). Davon sind ihr 5,14 % (982.355 Stimmrechte) nach §22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG in Verbindung mit §22 Abs. 1 Satz 2 zuzurechnen.

Die Henderson Holdings Group Limited, London, UK, hat uns gemäß §21 Abs. 1 WpHG am 1. September 2015 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 23. Januar 2014 die Schwelle von 5 % überschritten hat und zu diesem Tag 5,14 % beträgt (982.355 Stimmrechte). Davon sind ihr 5,14 % (982.355 Stimmrechte) nach §22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG in Verbindung mit §22 Abs. 1 Satz 2 zuzurechnen.

Die HGI Group Limited, London, UK, hat uns gemäß §21 Abs. 1 WpHG am 1. September 2015 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 23. Januar 2014 die Schwelle von 5 % überschritten hat und zu diesem Tag 5,14 % beträgt (982.355 Stimmrechte). Davon sind ihr 5,14 % (982.355 Stimmrechte) nach §22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG in Verbindung mit §22 Abs. 1 Satz 2 zuzurechnen.

KORREKTUR:

1. Die Henderson Group Holdings Asset Management Limited, London, UK, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 9. Dezember 2015 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 23. Januar 2014 die Schwelle von 5 % überschritten hat und zu diesem Tag 5,14 % beträgt (982.355 Stimmrechte). Davon sind ihr 5,14 % (982.355 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG in Verbindung mit § 22 Abs. 1 Satz 2 zuzurechnen. Der Henderson Horizon Fund, SICAV, hält 3 % oder mehr der Stimmrechte, die dem Meldenden gemäß § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2–6 bzw. Abs. 2 WpHG zugerechnet werden.

2. Die HGI Asset Management Group Limited, London, UK, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 9. Dezember 2015 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 23. Januar 2014 die Schwelle von 5 % überschritten hat und zu diesem Tag 5,14 % beträgt (982.355 Stimmrechte). Davon sind ihr 5,14 % (982.355 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG in Verbindung mit § 22 Abs. 1 Satz 2 zuzurechnen. Der Henderson Horizon Fund, SICAV, hält 3 % oder mehr der Stimmrechte, die dem Meldenden gemäß § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2–6 bzw. Abs. 2 WpHG zugerechnet werden.

3. Die Henderson Global Group Limited, London, UK, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 9. Dezember 2015 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 23. Januar 2014 die Schwelle von 5 % überschritten hat und zu diesem Tag 5,14 % beträgt (982.355 Stimmrechte). Davon sind ihr 5,14 % (982.355 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG in Verbindung mit § 22 Abs. 1 Satz 2 zuzurechnen. Der Henderson Horizon Fund, SICAV, hält 3 % oder mehr der Stimmrechte, die dem Meldenden gemäß § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2–6 bzw. Abs. 2 WpHG zugerechnet werden.

4. Die Henderson Holdings Group Limited, London, UK, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 9. Dezember 2015 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 23. Januar 2014 die Schwelle von 5 % überschritten hat und zu diesem Tag 5,14 % beträgt (982.355 Stimmrechte). Davon sind ihr 5,14 % (982.355 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG in Verbindung mit § 22 Abs. 1 Satz 2 zuzurechnen. Der Henderson Horizon Fund, SICAV, hält 3 % oder mehr der Stimmrechte, die dem Meldenden gemäß § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2–6 bzw. Abs. 2 WpHG zugerechnet werden.

5. Die HGI Group Limited, London, UK, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 9. Dezember 2015 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 23. Januar 2014 die Schwelle von 5 % überschritten hat und zu diesem Tag 5,14 % beträgt (982.355 Stimmrechte). Davon sind ihr 5,14 % (982.355 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG in Verbindung mit § 22 Abs. 1 Satz 2 zuzurechnen. Der Henderson Horizon Fund, SICAV, hält 3 % oder mehr der Stimmrechte, die dem Meldenden gemäß § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2–6 bzw. Abs. 2 WpHG zugerechnet werden.

Die Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main, Deutschland, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 28. Januar 2016 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 25. Januar 2016 die Schwelle von 5 % unterschritten hat und zu diesem Tag 4,86 % beträgt (929.356 Stimmrechte). Davon sind ihr 4,86 % (929.356 Stimmrechte) nach § 22 WpHG zuzurechnen.

Die Dimensional Holdings Inc., Austin, Texas, USA, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 3. März 2016 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 25. Februar 2016 die Schwelle von 3 % überschritten hat und zu diesem Tag 3,004 % beträgt (574.300 Stimmrechte). Davon sind ihr 3,004 % (574.300 Stimmrechte) nach § 22 WpHG zuzurechnen.

(41) Freigabe des Abschlusses

Der Vorstand der SÜSS MicroTec AG hat den IFRS-Konzernabschluss am 9. März 2016 zur Weitergabe an den Aufsichtsrat freigegeben. Der Aufsichtsrat hat die Aufgabe, den Konzernabschluss zu prüfen und zu erklären, ob er den Konzernabschluss billigt.

Garching, 9. März 2016

Der Vorstand



Dr. Per-Ove Hansson
Vorstandsvorsitzender



Michael Knopp
Finanzvorstand



Walter Braun
Produktionsvorstand

Versicherung der gesetzlichen Vertreter

Wir versichern nach bestem Wissen, dass gemäß den anzuwendenden Rechnungslegungsgrundsätzen der Konzernabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt und im Konzernlagebericht, der mit dem Lagebericht der SÜSS MicroTec AG zusammengefasst ist, der Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses und die Lage des Konzerns so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird, sowie die wesentlichen Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung des Konzerns beschrieben sind.

Garching, 9. März 2016

SÜSS MicroTec AG



Dr. Per-Ove Hansson
Vorstandsvorsitzender



Michael Knopp
Finanzvorstand



Walter Braun
Produktionsvorstand

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den von der SÜSS MicroTec AG, Garching, aufgestellten Konzernabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Gesamtergebnisrechnung, Eigenkapital-Veränderungsrechnung, Kapitalflussrechnung und Anhang – sowie den Konzernlagebericht, der mit dem Lagebericht der SÜSS MicroTec AG zusammengefasst ist, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2015 bis 31. Dezember 2015 geprüft. Die Aufstellung von Konzernabschluss und Konzernlagebericht nach den IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315a Abs. 1 HGB anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Konzernabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Konzernabschluss unter Beachtung der anzuwendenden Rechnungslegungsvorschriften und durch den Konzernlagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Konzerns sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontroll-Systems sowie Nachweise für die Angaben im Konzernabschluss und Konzernlagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der Jahresabschlüsse der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen, der Abgrenzung des Konsolidierungskreises, der angewandten Bilanzierungs- und Konsolidierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Konzernabschluss der SÜSS MicroTec AG, Garching, den IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315a Abs. 1 HGB anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung dieser Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns. Der Konzernlagebericht steht in Einklang mit dem Konzernabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

München, den 17. März 2016

BDO AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

S. Wiedemann
Wirtschaftsprüfer

T. Steiner
Wirtschaftsprüfer

Glossar

3D-INTEGRATION

3D-Integration unterteilt sich in zwei Hauptkategorien: das 3D-Packaging und 3D-Interconnect. 3D-Packaging bezeichnet Bauteile, die auf Wafer Level Packaging-Ebene gestapelt werden ohne durch sogenannte Through-Silicon Vias (TSV) miteinander verbunden zu sein. Unter 3D-Packaging werden Technologien wie SOC (System-on-a-Chip) sowie weitere Verfahren subsumiert, bei denen die Verbindung üblicherweise auf Wire Bonding (Drahtbonden) basiert. 3D-Interconnect beinhaltet dagegen Bauteile, die durch Through-Silicon Vias (TSV) verbunden sind. Dabei handelt es sich um vertikale Durchkontaktierungen durch das in der Regel stark gedünnte massive Silizium.

300-MM-TECHNOLOGIE

Wafer sind runde Scheiben z. B. aus einkristallinem Reinst-Silizium, das als Grundmaterial für die Herstellung von Mikrochips dient. Der allergrößte Teil (~42 %) der heute weltweit verwendeten Silizium-Scheiben hat einen Durchmesser von 300 mm. Je größer der Durchmesser des Wafers, umso größer ist auch die Anzahl der Chips, die auf einem Wafer hergestellt werden können. Je höher die Anzahl der Chips, die auf einem Wafer hergestellt werden können, desto geringer sind die Produktionskosten pro individuellem Chip.

ADVANCED PACKAGING

Mit dem Begriff „Packaging“ wird die Technologie des „Verpackens“ von Mikrochips in Gehäuse bezeichnet. Dabei müssen alle Anschlusskontakte des Mikrochips einzeln auf die Außenseite des Gehäuses geführt werden, um dann die Verbindung zur Leiterplatte zu gewährleisten. Unter Advanced Packaging versteht man weiterentwickelte Packaging-Verfahren, die in der Regel Methoden einsetzen, die bisher nur bei der Herstellung der Mikrochips selbst, also im sogenannten Frontend der Chipfertigung eingesetzt wurden. Als Beispiel können hier Lithografie und Fotoresist-Techniken genannt werden.

BACKEND

Backend bezeichnet den zweiten (hinteren) Teil der Fertigungskette in der Mikrochipfertigung. Nachdem der Wafer sämtliche Prozessschritte zur Herstellung des eigentlichen Mikrochips durchlaufen hat (Frontend), beginnt der Backend-Prozess. Dort werden die Mikrochips auf dem Wafer getestet und ggf. für das Bonden vorbereitet.

Danach werden die Wafer in die einzelnen Mikrochips zersägt und diese werden in Gehäuse „verpackt“. Aus Kostengründen findet der Backend-Prozess überwiegend in Asien statt, wo die Halbleiterhersteller eigene Backend-Werke betreiben oder Test und Packaging bei Drittfirmen (Foundries) durchführen lassen.

BELACKER (BESCHICHTUNGSGERÄT)

Belacker sind Spezialmaschinen für die Halbleiterfertigung, die einen fotoempfindlichen Lack mittels Rotationskraft auf dem Wafer verteilen.

BONDEN

Mit dem Begriff „Bonden“ bezeichnet man das Verbinden von zwei oder mehreren Bauteilen oder Wafern mit Hilfe verschiedener chemischer und physikalischer Effekte, z. B. bedeutet „adhesives Bonden“ das Verkleben zweier Bauteile durch Klebstoffe (meistens Epoxidharze oder Fotoresist); „Fusion Bond“ oder „Direct Bond“ ist das direkte Verbinden zweier Wafer, die zunächst nur durch die schwachen atomaren Kräfte von Wassermolekülen in der Grenzschicht (Van-der-Waals-Kräfte) miteinander verbunden werden. Durch ein anschließendes Ausheizen werden die Wassermoleküle aufgebrochen und die frei werden Sauerstoffatome verbinden sich mit Siliziumatomen des Wafers zu Siliziumoxid (kovalente Bindung). Diese Bindung stellt eine sehr feste, nichtlösbare Verbindung der beiden Wafer dar.

BUMP

(engl.: Unebenheit); metallische (Lot, Gold, o. ä.), dreidimensionale Kontaktstelle auf einem Chip. Kann vereinfacht auch als Lotkugelchen auf einem einzelnen Anschlusskontakt eines Mikrochips bezeichnet werden.

CHIP

Allgemeiner Begriff für Halbleiterbauelemente. In der Elektronik versteht man unter einem Chip oder Mikrochip den IC (Integrated Circuit), der in ein Gehäuse eingebettet ist. Von außen sieht man in der Regel nur das schwarze Gehäuse und die Anschlussstelle, mit denen der Chip mit der Leiterplatte verbunden wird (durch Wire Bonding oder Flip Chip Bonding). Als Chip oder Mikrochip wird häufig aber auch nur das Stück Silizium bezeichnet, das im Gehäuse sitzt.

CLUSTER

Eine Gerätegruppe von einzelnen Prozessmodulen (z. B. Belacker, Aligner), die von einem zentral angeordneten Roboter mit den zu bearbeitenden Wafern bestückt wird.

COMPOUND SEMICONDUCTOR

siehe Verbindungshalbleiter

COST-OF-OWNERSHIP

Bewertet Anschaffungs- und Betriebskosten sowie die Kosten für Reinraumfläche, Verbrauch und Wartung der Maschinen. Diese Kosten werden dann in Bezug auf den Anteil funktionsfähiger Bauteile am Ende des Herstellungsverfahrens berechnet. Je höher die Ausbeute an perfekten Chips, desto besser ist die Cost-of-Ownership der Maschinen für den Kunden. Eine hervorragende Cost-of-Ownership ist besonders im Rahmen der Massenproduktion von großer Bedeutung.

DIE

„Die“, IC (Integrated Circuit) und Chip sind oft synonym verwendete Begriffe. „Die“ heißen die ICs, solange sie noch nicht in das Gehäuse integriert wurden. Solange der Wafer also die einzelnen Prozessschritte durchläuft, spricht man von „Dies“. Erst nach dem Vereinzeln und Verpacken der „Dies“ spricht man von Chips.

DRAM

DRAM steht für Dynamic Random Access Memory. Elektronischer Speicherbaustein, der hauptsächlich in Computern eingesetzt wird.

FAB

(engl.: Fabrik); Fabriken, die sich auf die Produktion von ICs auf Wafern (Chips) spezialisiert haben. Die Errichtung einer großen modernen Fab mit den erforderlichen Reinräumen und Maschinen (Equipment) kostet heute ca. 1,5 bis 4 Mrd. USD.

FLIP CHIP BONDING

Fortschrittliche Verbindungstechnik zwischen Mikrochip und Chipgehäuse, die höhere Taktfrequenzen bei der Signalübertragung ermöglicht. Die aktive Chipseite zeigt dabei nach unten, d. h. der Chip muss vor der Montage umgedreht (engl.: to flip) werden.

FOTORESIST

Lichtempfindliches Material, das zunächst als Schicht auf den Wafer aufgetragen wird und dann mit Hilfe von UV-Licht durch eine Maske hindurch belichtet wird. An den belichteten Stellen werden durch das UV-Licht chemische Veränderungen erzeugt. Diese Teilbereiche werden während der Entwicklung aus der Schicht herausgelöst, so dass eine reliefartige Struktur im Fotoresist entsteht. Dieser Prozess ist dem in der Fotografie sehr ähnlich.

FOUNDRY

Foundry ist eine Fabrik zur Chipherstellung, in der Mikrochips nach einem vom Kunden vorgegebenen Design der Schaltkreise gefertigt werden. Es handelt sich somit um eine Art Auftragsfertigung. Da den Foundry-Betreibern keine Kosten für das Chip-Design sowie für den Vertrieb und das Marketing ihrer Produkte entstehen, können sie ihre Forschung und Entwicklung für Ressourcen vollständig auf die Prozesstechnologie konzentrieren. Die weltweit führenden Foundries sind in Taiwan und Singapur angesiedelt.

FRONTEND

Frontend-Prozesse sind sämtliche Produktionsschritte, die der Wafer als Ganzes durchläuft. Hier wird der Chip an sich hergestellt. Danach schließt sich das Backend an. Dort werden die Mikrochips auf dem Wafer getestet, der Wafer anschließend in die einzelnen Chips zersägt, die dann mit einem Gehäuse versehen werden.

HALBLEITER

Ein kristalliner Werkstoff, dessen elektrischer Widerstand sich durch das Implantieren von Fremdatomen in das Kristallgitter verändern lässt. Silizium ist das wichtigste und am häufigsten vorkommende Halbleiterelement. Auch ICs aus diesem Werkstoff werden oft Halbleiter genannt.

IC

Integrated Circuit, ein integrierter Schaltkreis besteht aus elektronischen Bauelementen wie Transistoren, Widerständen und Kondensatoren, die auf engstem Raum auf einem Mikrochip integriert sind. Heute werden viele zehn Millionen solcher Zellen auf einem Chip integriert und miteinander verschaltet. Die hohe Integrationsdichte von Mikrochips hat zu einer enormen Leistungsfähigkeit der Chips geführt.

IDM (INTEGRATED DEVICE MANUFACTURER)

Hierbei handelt es sich um Unternehmen in der Halbleiter-Branche, die Halbleiter-Bauteile selbst entwickeln, produzieren und vermarkten.

LASERPROZESSIERUNG

Neue Entwicklungen in der Festkörper-Laser-Technologie, wie z. B. die hochleistungsfähigen UV-Laser mit hohen Pulsraten in Pikosekunden, haben die Anwendungsmöglichkeiten für Laser um die Mikrostrukturierung erweitert. SÜSS MicroTec bietet zwei Lasertechnologien an:

Excimer-Laserabdampfung: In der Mikrostrukturierung bietet der Einsatz von Excimer-Laser vor allem Möglichkeiten für eine Materialabdampfung. Durch Beschuss mit gepulster Laserstrahlung lässt sich Material von einer Oberfläche abtragen. Dabei stößt eine photochemische Reaktion eine Elektronenanregung an, die in einem plötzlichen Druckanstieg und einer explosiven Abtragung von Material in Form von Monomeren und Gasen resultiert. Die thermische Wirkung ist hierbei minimal – die Prozesstechnologie schont temperaturempfindliche Materialien. Die Systeme verwenden eine Photomaske, die mit einem Laserstrahl beleuchtet wird. Eine Projektionsoptik zwischen Maske und Wafer bildet, ähnlich einem Projektionsstepper in der Lithografie, die Maskenstrukturen auf dem Wafer ab. Jedoch wird das Material nicht belichtet, sondern direkt abgetragen. Mit einem Step-and-Repeat-Verfahren wird der komplette Wafer strukturiert.

Prozessierung mit Festkörper-Laser: Die Festkörper-Laser-Technologie verspricht alle Vorteile der Laserprozessierung: Sie erreicht hohe Auflösungen von bis zu zwei Mikrometer und sorgt für besonders präzise Ergebnisse. Strukturierungsprozesse laufen ohne thermische Nebenwirkungen ab. Die Systeme kommen ohne Maske aus und verwenden eine direkte Schreibmethode.

LED

Light Emitting Diode; Leuchtdioden sind Halbleiterbauteile, die Licht erzeugen können. LEDs leuchten sehr hell und verbrauchen gleichzeitig sehr wenig Energie. Darüber hinaus haben sie eine mehr als zehnmal so große Lebensdauer wie eine normale Glühlampe.

LITHOGRAFIE

Die elektrischen Schaltkreise der ICs werden durch Strukturierung einzelner Ebenen auf einem Siliziumwafer in einer Art Schichtenaufbau hergestellt. Um die sehr kleinen Strukturen in den einzelnen Schichten zu erzeugen, wird der Wafer mit einem lichtempfindlichen Material (Fotoresist) beschichtet und dann unter Verwendung einer Maske belichtet. Die Strukturen auf der

Maske werden so mittels Schattenwurf auf den Wafer aufgebracht. An Stellen, an denen die Maske lichtundurchlässig ist, wird der Fotoresist auf dem Wafer nicht belichtet. An lichtdurchlässigen Stellen der Maske fällt Licht auf den Wafer und der Fotoresist wird belichtet. Während der Entwicklung im Anschluss an die Belichtung werden die Stellen des Fotoresist, die durch die transparenten Stellen der Maske belichtet wurden, aus der Schicht herausgelöst und der Wafer wird an diesen Stellen freigelegt. Typische Strukturgrößen für Lithografieanwendungen im Frontend liegen heute in einer Größenordnung von 32 nm (0,032 µm) bis 0,6 µm. Im Backend werden Strukturgrößen von einigen Mikrometern bis einigen zehn Mikrometern fotolithografisch erzeugt, z. B. um die Bumps für das Flip Chip Bonding herzustellen.

MASKE

Eine teiltransparente Platte aus Glas oder Quarzglas, auf der die Muster abgebildet sind, die zur Herstellung eines IC benötigt werden; die Muster bestehen aus durchsichtigen und undurchsichtigen Bereichen entsprechend der Größe und Form der gewünschten Schaltkreise.

MASK ALIGNER (BELICHTUNGSGERÄT)

Mask Aligner richten eine Glasmaske submikrometergenau zu einem Wafer aus. Das mikroskopische Bild auf der Glasmaske wird mittels Belichtung auf den belackten Wafer übertragen.

MEMS

MEMS steht für Micro Electro Mechanical System und ist der vor allem in Nordamerika verwendete Begriff für die Mikrosystemtechnik (MST, in Europa gebräuchlicher). Fertigungstechnologien und Prozesse der Halbleiterfertigung werden eingesetzt, um mechanische und andere nichtelektronische Elemente herzustellen. MEMS-Produkte werden beispielsweise in der Automobilindustrie, der Telekommunikation, der Optoelektronik und der Medizintechnik eingesetzt.

MIKROMETER/MIKRON

Metrisches Längenmaß; Symbol: µm. Ein Mikrometer ist ein Millionstel Meter. Zur Veranschaulichung: Der Durchmesser eines menschlichen Haares beträgt ca. 60 µm.

MIKROSYSTEM

Ein aus verschiedenen Bauteilen, die in der Dimension unterhalb eines Millimeters liegen, zusammengesetztes System.

MIKROSYSTEMTECHNIK

Je nach Region gibt es die unterschiedlichsten Definitionen des Begriffs. In Europa wird damit die gesamte Verkleinerung von Bauteilen aus der Feinwerktechnik in den Bereich von Strukturen unterhalb eines Millimeters verstanden. In den USA und Asien bedeutet Micro System Technology oder der häufiger verwendete Begriff Micro Electro Mechanical Systems (MEMS) den Einsatz von Techniken der Halbleiterelektronik zur Erzeugung kleinster Sensoren oder aber auch komplexer Systeme, wie z. B. einer kompletten chemischen oder biologischen Analyseeinheit. MEMS-Baugruppen sind z. B. der Beschleunigungssensor aus Silizium, der zum Auslösen des Airbags eingesetzt wird, oder aber die Düse in der Patrone des Tintenstrahldruckers.

NANOIMPRINTING/NANO IMPRINT LITHOGRAFIE (NIL)

Ein mechanisches Verfahren, mit dem zwei- oder dreidimensionale Strukturen im Nanometerbereich mit einem Abformwerkzeug oder Stempel hergestellt werden. Im Gegensatz zur fotolithografischen Erzeugung von Schaltungen auf Halbleiter-Wafern werden die Strukturen durch „Stempeln“ in einem weichen Kunststoff vorgegeben. Man erhofft sich vom Nanoimprinten in der Zukunft einen Preisvorteil, weil die Fortsetzung der Fotolithografie in Richtung höchste Auflösung extrem kurze Wellenlängen der Lichtstrahlung (EUV, Röntgen) benötigen wird, und das entsprechende Equipment unangemessen teuer zu werden droht.

NANOTECHNOLOGIE

Sammelbegriff für eine breite Auswahl von Technologien, die sich mit Strukturen und Prozessen im Größenbereich von einem bis mehreren hundert Nanometer befassen. Ein Nanometer ist ein Milliardstel Meter (10^{-9} m) und bezeichnet einen Grenzbereich, in dem die typischen Abmessungen von einzelnen Molekülen liegen. Nanotechnologie ist eine konsequente Fortsetzung und Erweiterung der Mikrotechnik mit meist völlig unkonventionellen neuen Ansätzen: Die Nanotechnologie beschäftigt sich damit, Werkstoffe und Strukturen im Nanometerbereich zu schaffen.

OPTOELEKTRONIK

Durch das gezielte Kombinieren von Technologien der Halbleiterelektronik mit sogenannten III/V-Materialien wie z. B. Galliumarsenid kann Licht erzeugt oder detektiert werden (Halbleiterlaser, LED, Fotodioden etc.). Diese Technologie wird hauptsächlich in der Telekommunikation für die Übertragung sehr großer Datenmengen (faseroptische Netze) eingesetzt. Allerdings finden LEDs wegen ihrer vielen Vorteile, wie des geringen Energiebedarfs, der sehr hohen Helligkeit und der sehr langen Lebensdauer, zunehmend Verwendung im Automobilbau und im Haushalt.

OSAT (OUTSOURCED ASSEMBLY AND TEST HOUSES)

Diese Unternehmen sind im Mid- und Backend der Halbleiterindustrie angesiedelt. Sie offerieren Packaging-Lösungen, Testsysteme und weitere Serviceleistungen für Halbleiterhersteller, ohne dabei an einen bestimmter Hersteller gebunden zu sein. Schwerpunkt ist häufig das Packaging und Assembly von ICs und anderen Halbleiterprodukten.

PACKAGING FOUNDRIES

siehe Backend

PROJEKTIONSLITHOGRAFIE

Während bei der Vollfeld-Lithografie (Mask Aligner) der komplette Wafer in einem Vorgang belichtet wird, werden bei projektionslithografischen Prozessen typischerweise nur einzelne Bereiche des Wafers unter Verwendung einer Projektionsoptik belichtet. Die komplette Belichtung des Wafers wird dann entweder schrittweise (Step and Repeat) oder kontinuierlich (Scan) durchgeführt. SÜSS MicroTec fertigt 1:1-Projektionsscanner für das Halbleiter-Mid- und Backend. Hierbei wird eine Vollfeldmaske verwendet und der Wafer in einem Scannvorgang belichtet. Eine Verkleinerung der Strukturgrößen von der Maske zum Wafer findet nicht statt. Die Projektionsscanner-Technologie von SÜSS MicroTec kombiniert Vorteile der Vollfeldbelichtung mit denen der klassischen Projektionslithografie und bietet eine Alternative zu Mask Aligner und Projektions-Steppern.

SENSOR

Ein Bauteil zum Erfassen und Umwandeln von Messgrößen wie Temperatur, Druck oder Beschleunigung; diese Größe wird in ein elektrisches Signal gewandelt und an eine Signalauswertungseinheit weitergegeben.

SILIZIUM

Werkstoff mit dem Aufbau eines Kristallgitters mit halbleitenden Eigenschaften; halbleitend bedeutet, dass je nach Einbau von bestimmten Fremdatomen der Werkstoff als elektrischer Leiter oder als Nichtleiter verwendet werden kann. In der Halbleiterindustrie wird Silizium in Form von Scheiben eines Einkristalls als der wesentliche Grundstoff verwendet.

SUBSTRAT BONDER (VERBINDUNGSGERÄT)

Der Substrat Bonder verbindet zwei oder mehr äußerst präzise zueinander ausgerichtete Substrate, meist Wafer, durch Lötten, Kleben oder andere physikalisch-chemische Verfahren miteinander. Viele MEMS-Bausteine benötigen diesen Prozessschritt. Erst dann können Airbags, Reifendrucksensoren, GPS-Sensoren, Tintenstrahldrucker, etc. funktionieren.

SYSTEM-ON-A-CHIP

Hochkomplexe ICs, die viele verschiedene Funktionen enthalten; bis vor Kurzem musste man diese noch auf mehreren ICs unterbringen. Die gewaltige Innovationskraft in der Prozesstechnik, die die Fertigung von ICs mit immer kleineren Strukturbreiten erlaubt, ermöglicht heute, dass auf einem Chip verschiedene Sorten von Speichern, digitale Signalprozessoren und analoge Funktionen untergebracht werden können. Vorteil hiervon ist, dass anstatt vieler Chips nur noch sehr wenige oder ein einzelner erforderlich sind, und sich so der Platzbedarf, der Montageaufwand (und damit die Kosten des Endprodukts) und, was sehr wichtig ist, die Leistungsaufnahme verringern. In batteriebetriebenen Geräten (Notebooks, Handys) verlängert sich so die Lebensdauer der Batterien. Der Trend zu immer kleineren und mobilen Geräten, die zudem immer günstiger werden sollen, verleiht System-on-a-Chip immer größere Bedeutung.

THROUGH-SILICON VIA (TSV)

Bei der Through-Silicon Via-Technik werden die einzelnen Chip-Komponenten übereinander gestapelt und mittels vertikaler Durchkontaktierungen (Through-Silicon Via) miteinander verbunden. Dadurch verkürzt sich der Weg des Datenstroms zwischen den einzelnen Chipkomponenten, und lassen sich Kapazitätsverluste wesentlich reduzieren. Through-Silicon Vias tragen somit zu einer Verringerung der Baugröße von Chips bei gleichzeitiger Steigerung der Leistungsfähigkeit bei.

TOOL

Maschinen, Werkzeuge, Roboter usw.; Tools sind alle Einzelsysteme, die in einer Halbleiterfabrik zu einer Produktionslinie kombiniert werden.

VERBINDUNGSHALBLEITER

Halbleiter, die sich aus mehreren Elementen zusammensetzen (Galliumarsenid, Indiumphosphid, Siliziumgermanium etc.); Vorteile gegenüber einfachen Element-Halbleitern: Verbindungshalbleiter sind besonders schnell und können auch bei sehr hohen Temperaturen arbeiten und verbrauchen trotzdem weniger Energie als einfache Siliziumchips.

WAFER

Runde Scheiben z.B. aus Reinst-Silizium oder Verbindungshalbleitern (Galliumarsenid, Indiumphosphid, etc.), auf denen Chips produziert werden; in den letzten zehn Jahren hat sich der Durchmesser von 150 über 200 auf heute sogar 300 mm vergrößert. Auf die Grundfläche der neuesten 300-mm-Wafer passen doppelt so viele Chips wie auf einen 200-mm-Wafer – die Produktionskosten sind dadurch ca. 30% niedriger.

WIRE BONDING

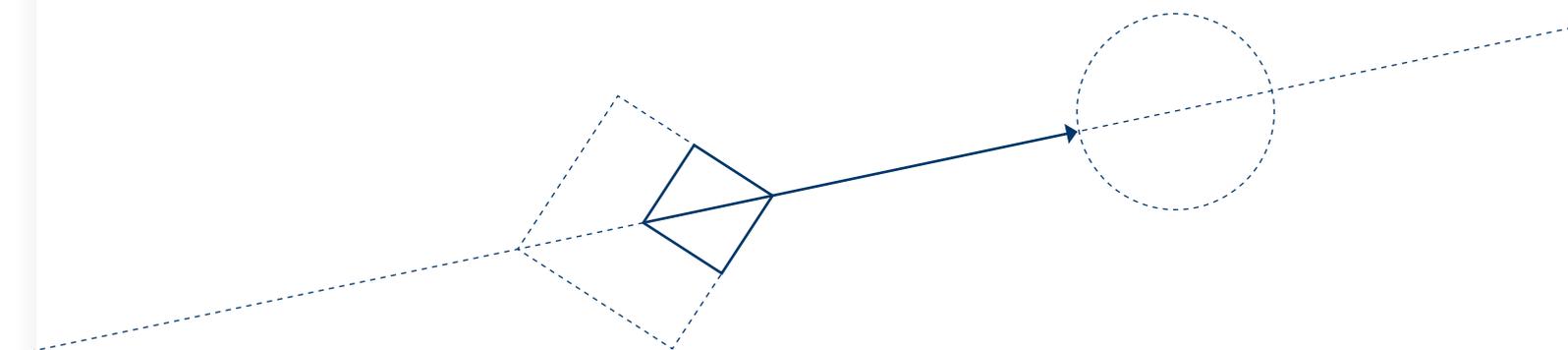
Gängiges Kontaktverfahren, um Chips über Metalldrähte mit einem Gehäuse zu verbinden

YIELD

Die Ausbeute ist eine der wesentlichen Kenngrößen in der Halbleiterfertigung. Sie bezeichnet die Ausbeute der funktionsfähigen Mikrochips im Verhältnis zur Gesamtzahl der Mikrochips auf einem Wafer. Je höher der Yield, desto effektiver und kostengünstiger ist die Chipproduktion für den Kunden.

Finanzkalender 2016

Geschäftsbericht 2015	30. März
Quartalsbericht 2016	04. Mai
Hauptversammlung 2016, Haus der Bayerischen Wirtschaft, München	15. Juni
Halbjahresfinanzbericht 2016	05. Aug
Neunmonatsbericht 2016	09. Nov



IMPRESSUM

Herausgeber	SÜSS MicroTec AG
Redaktion	Finance, Julia Natterer Investor Relations, Franka Schielke
Wirtschaftsprüfer	BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Konzept und Gestaltung	Whitepark GmbH & Co., Hamburg
Druck	Eberl Print GmbH, Immenstadt
Fotos	SÜSS MicroTec AG, Marek Vogel

KONTAKT

SÜSS MicroTec AG
Schleißheimer Straße 90
85748 Garching, Deutschland
Telefon: +49 (0)89-32007-0
E-Mail: info@suss.com

Investor Relations
Telefon: +49 (0)89-32007-161
E-Mail: ir@suss.com

Zukunftsorientierte Aussagen: Die Jahresberichte enthalten zukunftsorientierte Aussagen. Zukunftsorientierte Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, einschließlich Aussagen über Erwartungen und Ansichten des Managements der SÜSS MicroTec AG. Diese Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Plänen, Einschätzungen und Prognosen des Managements der Gesellschaft. Anleger sollten sich nicht uneingeschränkt auf diese Aussagen verlassen. Zukunftsorientierte Aussagen stehen im Kontext ihres Entstehungszeitpunkts. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in diesem Bericht enthaltenen zukunftsorientierten Aussagen aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse zu aktualisieren. Unberührt hiervon bleibt die Pflicht der Gesellschaft, ihren gesetzlichen Informations- und Berichtspflichten nachzukommen. Zukunftsorientierte Aussagen beinhalten immer Risiken und Ungewissheiten. Eine Vielzahl von Faktoren, die in diesem Bericht beschrieben sind, können dazu führen, dass die tatsächlich eintretenden Ereignisse erheblich von den in diesem Bericht enthaltenen zukunftsorientierten Aussagen abweichen.

Fünfjahresübersicht

in Mio. €	2015	2014	2013	2012	2011
Geschäftsentwicklung					
Auftragseingang	188,6	134,3	135,0	157,2	143,1
Auftragsbestand zum 31.12.	117,6	75,6	85,7	86,5	83,7
Umsatz gesamt	148,5	145,3	134,5	163,8	175,4
Umsatzrendite	0,1 %	3,2 %	-11,9 %	4,6 %	7,9 %
Rohertrag	49,4	48,8	21,8	57,4	66,4
Rohertragsmarge	33,3 %	33,6 %	16,2 %	35,0 %	37,9 %
Herstellungskosten	99,2	96,5	112,7	106,4	109,1
Forschungs- und Entwicklungskosten	12,8	10,5	10,2	9,7	12,9
EBITDA	9,2	12,6	-13,4	18,6	24,9
EBITDA-Marge	6,2 %	8,7 %	-10,0 %	11,4 %	14,2 %
EBIT	5,0	8,4	-19,4	11,7	18,6
EBIT-Marge	3,4 %	5,8 %	-14,4 %	7,1 %	10,6 %
Ergebnis nach Steuern	0,2	4,6	-16,0	7,6	13,8
Ergebnis je Aktie, unverwässert (in €)	0,01	0,24	-0,84	0,40	0,72
Bilanz und Cashflow					
Eigenkapital	118,7	116,1	109,4	127,2	120,4
Eigenkapitalquote	67,0 %	69,1 %	60,8 %	70,5 %	64,1 %
Eigenkapitalrentabilität	0,2 %	4,0 %	-14,6 %	6,0 %	11,5 %
Bilanzsumme	177,2	168,0	179,9	180,4	187,7
Net Cash	40,0	38,0	35,7	32,3	42,0
Free Cashflow ¹	1,3	2,1	4,1	-4,5	3,5
Weitere Kennzahlen					
Investitionen	3,4	3,0	12,2	4,2	3,4
Investitionsquote	2,3 %	2,1 %	9,1 %	2,6 %	1,9 %
Abschreibungen	4,2	4,2	6,0	6,8	6,4
Mitarbeiter zum 31.12.	698	659	655	704	624

¹ vor Berücksichtigung von Wertpapiererwerben und Wertpapierverkäufen



SÜSS MicroTec AG
Schleißheimer Straße 90
85748 Garching, Deutschland
Telefon: +49 (0)89-32007-0
E-Mail: info@suss.com
www.suss.com